

GEMEINSAM. GROSSES. SCHAFFEN.

Geschäftsbericht 2017

KENNZAHLEN

<i>in Mio. €</i>	31.12.2017	31.12.2016	Veränderung 2017/2016
Geschäftsentwicklung			
Auftragseingang	200,3	161,1	24,3%
Auftragsbestand zum 31.12.	133,4	101,5	31,4%
Umsatz gesamt	166,5	177,6	-6,2%
Umsatzrendite	4,0%	2,8%	1,2%-Punkte
Rohertrag	59,5	58,6	1,5%
Rohertragsmarge	35,7%	33,0%	2,7%-Punkte
Herstellungskosten	107,0	119,0	-10,1%
Forschungs- und Entwicklungskosten	15,2	14,1	7,8%
EBITDA	18,0	15,3	17,6%
EBITDA-Marge	10,8%	8,6%	2,2%-Punkte
EBIT	13,9	11,1	25,2%
EBIT-Marge	8,3%	6,3%	2,1%-Punkte
Ergebnis nach Steuern	6,7	5,0	34,0%
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in EUR)	0,35	0,26	34,6%
Bilanz und Cashflow			
Eigenkapital	127,0	124,4	2,1%
Eigenkapitalquote	62,9%	69,2%	-6,3%-Punkte
Eigenkapitalrentabilität	5,3%	4,0%	1,3%-Punkte
Bilanzsumme	202,0	179,6	12,5%
Net Cash	33,0	31,1	6,1%
Free Cashflow	2,9	-9,1	-
Weitere Kennzahlen			
Investitionen	6,5	3,6	80,6%
Investitionsquote	3,9%	2,0%	1,9%-Punkte
Abschreibungen	4,1	4,2	-2,4%
Mitarbeiter zum 31.12.	779	711	9,6%

GEMEINSAM STARK

LITHOGRAFIE

- Mask-Aligner
- UV-Projektionsbelichtungssysteme
- Laser-Prozessierungssysteme
- Belacker/Entwickler

Auftragseingang: **136,2 Mio. €**
Umsatz: **112,8 Mio. €**
EBIT: **6,3 Mio. €**

BONDER

- Bonder

Auftragseingang: **36,7 Mio. €**
Umsatz: **22,1 Mio. €**
EBIT: **3,3 Mio. €**

FOTOMASKEN-EQUIPMENT

- Fotomasken-Bearbeitungssysteme

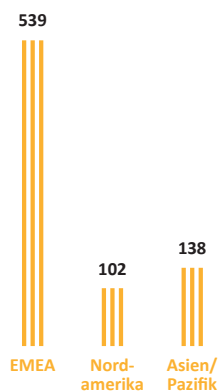
Auftragseingang: **15,7 Mio. €**
Umsatz: **19,7 Mio. €**
EBIT: **5,1 Mio. €**

SONSTIGE

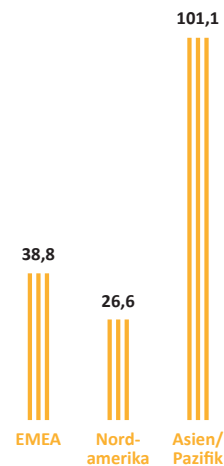
- Mikrooptik und -linsen
- Zentrale Konzernfunktionen

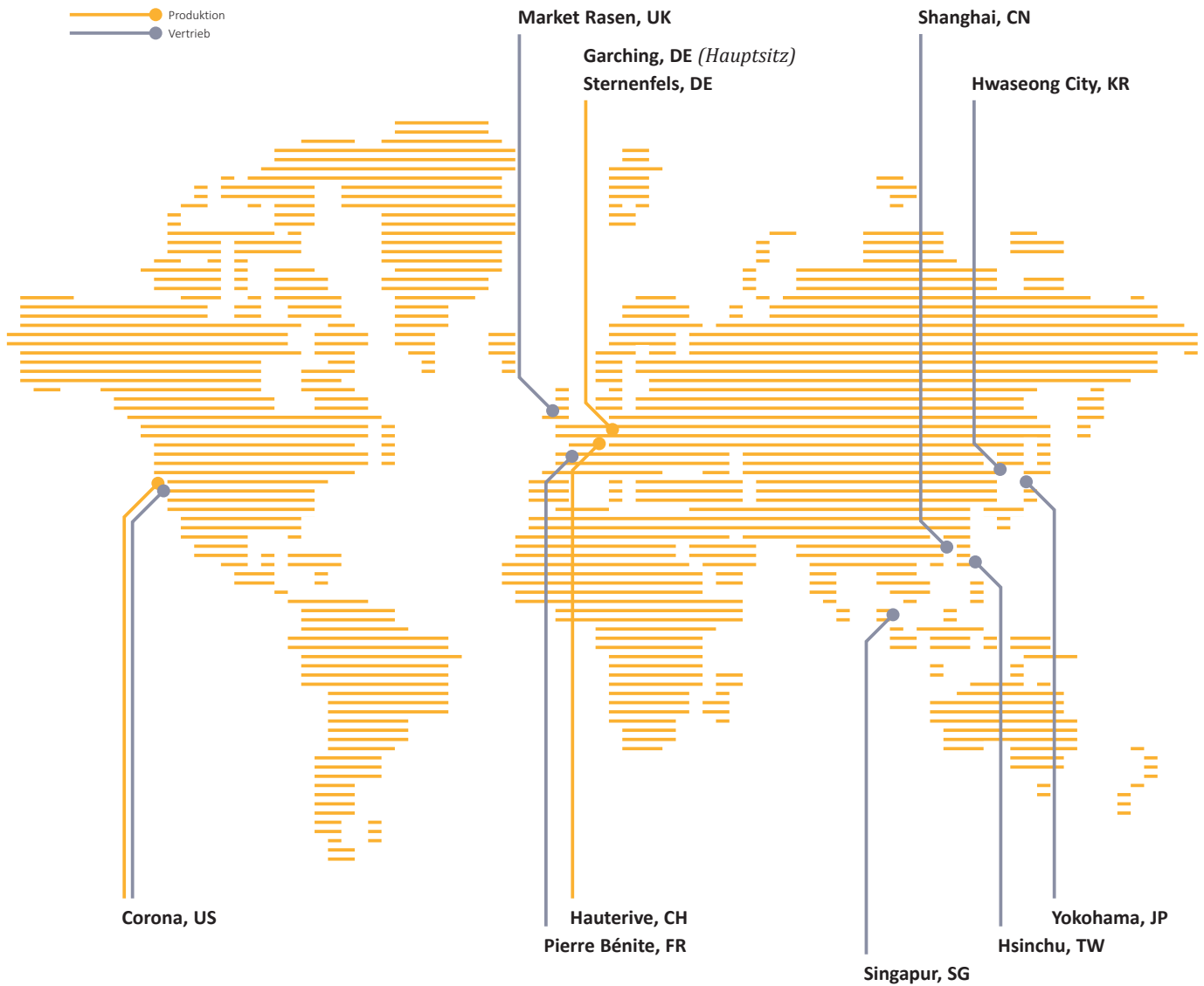
Auftragseingang: **11,7 Mio. €**
Umsatz: **11,9 Mio. €**
EBIT: **-0,8 Mio. €**

MITARBEITER NACH REGIONEN



UMSATZ NACH REGIONEN in Mio. €





UMSATZ NACH REGIONEN

16,0 %

Nordamerika

23,3 %

EMEA

60,7 %

Asien / Pazifik

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

BEI SÜSS MICROTEC TEILEN WIR EINE GROSSE LEIDENSCHAFT: WIR BEGEISTERN UNS FÜR INNOVATIVE TECHNOLOGIEN. OB ALS MITARBEITER IM TECHNISCHEN BEREICH ODER IN DER VERWALTUNG, OB IM VORSTAND ODER ALS MITGLIED DES AUFSICHTSRATS. HIERBEI KONZENTRIEREN WIR UNS GANZ AUF DIE ANFORDERUNGEN UNSERER KUNDEN. EIN GUT FUNKTIONIERENDER INFORMATIONSAUSTAUSCH ZWISCHEN DEN KUNDEN IN DEN LOKALEN MÄRKTEN IN ASIEN UND NORDAMERIKA AUF DER EINEN SEITE, SOWIE DEN ENTWICKLERN UND INGENIEUREN IN DEN PRODUKTIONSSTÄTTEN AUF DER ANDEREN SEITE IST DIE VORAUSSETZUNG, UM PUNKTGENAU DIE ERWARTUNGEN UNSERER KUNDEN ZU TREFFEN. NUR BEI GENAUER KENNTNIS DER WÜNSCHE UND FORDERUNGEN KÖNNEN WIR MIT HILFE UNSERER INNOVATIONSKRAFT UND KREATIVITÄT ÜBERZEUGENDE LÖSUNGEN FÜR SIE FINDEN. DESHALB WERDEN WIR UNSERE KOMMUNIKATIONSWEGE WEITER VERBESSERN UND FÜR EINEN FUNKTIONIERENDEN AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN, ABTEILUNGSÜBERGREIFEND UND ÜBER LÄNDERGRENZEN HINWEG, SORGEN. DIE STÄNDIG STEIGENDEN ANFORDERUNGEN, DIE AUCH ZUKÜNFTIG AN UNS GESTELLT WERDEN, KÖNNEN WIR NUR GEMEINSAM – ALS TEAM – ERFÜLLEN.

IHR SÜSS MICROTEC-VORSTAND

INHALT

Vorwort des Vorstands	4
Bericht des Aufsichtsrats	6
Gemeinsam. Großes. Schaffen.	10
Investor Relations	38
Corporate Governance	42
Nichtfinanzielle Konzernklärung gemäß § 315b HGB	50
Zusammengefasster Lagebericht	58
Konzernabschluss nach IFRS	106
Anhang zum IFRS-Konzernabschluss	122
Glossar	158
Finanzkalender 2018	<i>Umschlagseite hinten</i>
Fünffjahresübersicht	<i>Umschlagseite hinten</i>

VORWORT DES VORSTANDS

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre

für das Geschäftsjahr 2017 lagen frühzeitig positive Konjunkturprognosen vor. Die schwierigen politischen Rahmenbedingungen haben diese Prognosen nicht spürbar beeinträchtigt. Noch zu Jahresbeginn herrschte Unsicherheit über die Zukunft der Europäischen Union. Nach der Entscheidung im Jahr 2016 über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) haben die Wähler in den Niederlanden und Frankreich im Frühjahr 2017 für ein geeintes und starkes Europa gestimmt. Zum Jahresende 2017 hin zeigten weder die langwierige Regierungsbildung in Deutschland noch die Spannungen zwischen Nordkorea, den USA und Japan spürbare Auswirkungen auf die deutsche, europäische oder globale Konjunktur.

Unser direktes industrielles Umfeld ist derzeit von gut gefüllten Auftragsbüchern sowie einem weiterhin positiven Ausblick geprägt. In seinen Schätzungen vom Herbst 2017 erwartet das Marktforschungsinstitut Gartner für das Jahr 2017 ein Rekordwachstum des gesamten Halbleitermarktes um rund 20 Prozent auf ein Gesamtvolumen von 419 Mrd. US-Dollar. Für 2018 wird ein weiteres Wachstum des Marktvolumens auf rund 451 Mrd. US-Dollar erwartet. Der Hauptgrund hierfür ist die hohe Nachfrage nach Speicherelementen wie NAND und DRAM für Anwendungen in den Bereichen mobile Kommunikation, Spielekonsolen sowie für Serverapplikationen und SSD-Speichermedien. Natürlich sind hier auch die generell zunehmende Vernetzung, das Internet der Dinge oder Themen wie autonomes Fahren und Industrie 4.0 zu berücksichtigen.

Für das Jahr 2017 veröffentlichte das Statistische Bundesamt ein Plus von 2,2 Prozent Wachstum in Deutschland statt 1,5 Prozent wie noch zu Jahresbeginn 2017 erwartet worden war. Im Jahr 2018 sollen es sogar 2,0 Prozent werden, bislang erwarteten die Experten 1,7 Prozent für 2018. Getragen wird diese Entwicklung von einer robusten Binnennachfrage, aber zunehmend auch vom wachsenden Auslandsgeschäft sowie steigenden Investitionsausgaben. Im OECD Economic Outlook vom Juni 2017 wird für die Weltkonjunktur im laufenden Jahr ein Wachstum von 3,5 Prozent erwartet. Im Vorjahr waren es 3,0 Prozent. Die Weltwirtschaft befindet sich in einem robusten Aufschwung. Die wirtschaftspolitischen Anregungen in China haben zu einer neuerlichen Phase der Expansion geführt. Daneben zeigen auch der Euroraum, die USA und Japan ein solides gesamtwirtschaftliches Wachstum. In der Eurozone dürfte das Wachstum erwartungsgemäß bei 1,8 Prozent liegen, nach 1,7 Prozent im Vorjahr.

Die positive Marktstimmung zeigt sich nicht zuletzt auch in der guten Auftragsentwicklung von SÜSS MicroTec. Nach einem er-

folgreichen Geschäftsjahr 2016 konnten wir im Geschäftsjahr 2017 im Auftragseingang erneut deutlich zulegen und erreichten einen Wert von 200,3 Mio. Euro. Der Auftragseingang lag damit um 24,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Im Umsatz und Ergebnis verfehlte das Unternehmen aufgrund von Verzögerungen bei Produktabnahmen über den Jahresstichtag hinaus seine selbst gesteckten Ziele knapp und kam auf einen Umsatz von 166,5 Mio. Euro sowie ein EBIT von 13,9 Mio. Euro. Der Freie Cashflow entwickelte sich weiterhin positiv und erreichte einen Wert von 2,9 Mio. Euro. Dämpfend wirkte hier insbesondere der Aufbau der Vorräte vor dem Hintergrund des hohen Auftragsbestandes am Jahresende in Höhe von 133,4 Mio. Euro.

Neben der guten Entwicklung in den Kernproduktlinien Mask-Aligner, Belacker/Entwickler, Bonder und Fotomaschinen stand das Geschäftsjahr 2017 wesentlich im Zeichen der Entwicklung einer neuen Generation von UV-Projektionsscannern am Standort Corona, Kalifornien. Das Projekt liegt im Plan und wir werden im Verlauf des zweiten Quartals 2018 mit dem verbesserten Produkt an den Markt gehen. Die UV-Projektionsscanner sind insbesondere für neuartige Packaging-Anwendungen (Fan-out-Wafer-Level-Packaging) interessant und versprechen für die kommenden Jahre interessante Wachstumschancen für das Unternehmen. Darüber hinaus verspüren wir Bewegung im Markt für temporäre Bondsysteme. Im Geschäftsjahr 2017 wurden mehrere Systeme von einem Kunden in Auftrag gegeben. Diese temporären Bondsysteme wurden von einem international führenden IDM (Integrated-Device-Manufacturer) geordert, der bereits mehrere der Systeme in seiner laufenden Produktion erfolgreich einsetzt. Die Maschinen sind für das temporäre Bonden von 300-mm-Wafern für 3D-TSV-Integrationsprozesse bei Logik- und Speicheranwendungen konfiguriert. Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt von einer weiteren Belebung im Bereich 3D-TSV-Integration aus. Auf der Ebene der Endgeräte gibt es zudem einen starken Bedarf für mehr MEMS (mikro-elektromechanische Systeme) und optische Systeme, um eine noch schnellere Kommunikation und bessere Konnektivität zu unterstützen. Dies sind zukunftsweisende und anspruchsvolle Herausforderungen, bei denen wir unsere Kunden individuell und erfolgreich unterstützen.

Ein besonderes Augenmerk lag auf der stetigen Verschlankeung von internen Prozessen, der Verringerung der Durchlaufzeiten sowie der sinnvollen Nutzung von Outsourcing für die Herstellung von Modulen. Im Jahr 2017 wurde hierzu das Programm SÜSS Excellence gestartet, bei dem unsere internen Prozesse analysiert, vereinfacht und stets vor dem Hintergrund des Kundennutzens optimiert werden. Dies gilt für alle Unternehmensbereiche, egal ob in der Entwicklung, Produktion oder Verwaltung. Zudem wird das Thema Weiterbildung und Training durch das Excellence-Team forciert und weiter vorangetrieben.



Von links nach rechts:
Robert Leurs, Finanzvorstand
Dr. Franz Richter, Vorstandsvorsitzender
Walter Braun, Produktionsvorstand

Unbeeindruckt von geopolitischen Spannungen haben die Leitindizes der internationalen Aktienmärkte erneut neue Höchststände verzeichnen können. Auch die SÜSS MicroTec-Aktie entwickelte sich im Jahresverlauf sehr positiv, in der zweiten Jahreshälfte konnte die Aktie nachhaltig auf über 10 Euro ansteigen und erlebte im November Schlusskurse von teilweise über 18 Euro. Zum Jahresende 2017 notierte die Aktie bei 16,64 Euro und lag damit um rund 160 Prozent über dem Wert zum Jahresende 2016.

VERÄNDERUNGEN IN VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Sehr geehrte Damen und Herren, im Geschäftsjahr 2017 gab es erneut einen Wechsel im Vorstand des Unternehmens. Am 12. Oktober 2017 hat der Aufsichtsrat Herrn Robert Leurs mit Wirkung ab dem 1. Dezember 2017 als Finanzvorstand der SÜSS MicroTec SE bestellt. Herr Leurs verfügt über die Qualifikation als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und hat nach seiner achtjährigen Tätigkeit in einer globalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in den letzten 14 Jahren umfassende Erfahrungen in der Leitung der kaufmännischen Bereiche von international tätigen Unternehmen gesammelt. Herr Leurs tritt damit die Nachfolge von Herrn Michael Knopp an, der in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat seinen Dienstvertrag vorzeitig zum 30. April 2017 beendete, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

Auch im Aufsichtsrat gab es im Geschäftsjahr 2017 Veränderungen. Auf der Hauptversammlung 2017 wählten die Aktionäre die bestehenden drei Aufsichtsräte Herrn Dr. Stefan Reineck, Herrn Jan Teichert sowie Herrn Gerhard Pegam erneut für eine Periode von vier Jahren in den Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE, zudem wurde das Gremium auf vier Mitglieder erweitert. Mit Frau Dr. Myriam Jahn konnte der Aufsichtsrat eine Expertin für Digitalisierung im Maschinenbau gewinnen. Damit wird das Know-how in diesem Gremium um wichtige Kompetenzbereiche erweitert.

AUSBLICK

Nach dem sehr guten Auftragseingang im Geschäftsjahr 2017 blicken wir optimistisch in das Geschäftsjahr 2018. Das Marktumfeld in der Halbleiterindustrie sowie die generellen Konjunkturaussichten sind weiterhin positiv, auch wenn einige Marktanalysten bereits vor einer Überhitzung der Märkte und somit einem möglichen Rückgang des Wachstums warnen. SÜSS MicroTec startet mit einem hohen Auftragsbestand von 133,4 Mio. Euro in das neue Geschäftsjahr. Unter Berücksichtigung der zwar weiterhin positiven Aussichten für das erste Halbjahr 2018 gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2018 etwa den Durchschnitt der vergleichbaren Zeiträume der Vorjahre mit etwa 70 Mio. Euro bis 80 Mio. Euro erreichen wird, jedoch nicht den außergewöhnlich hohen Wert des Vorjahres (94,5 Mio. Euro). Darauf aufbauend erwarten wir für den Umsatz im Jahr 2018 einen Wert in der Bandbreite von 195 Mio. Euro bis 205 Mio. Euro. Bei diesem Umsatzniveau wird das EBIT für 2018 voraussichtlich in einer Bandbreite von 8,5 % bis 10,0 % und das EBITDA in einer Bandbreite von 11,0 % bis 12,5 % vom Umsatz liegen. Vergleichbare Lizenzerträge wie im Vorjahr erwarten wir für 2018 nicht. Die Gründe für die positive Entwicklung der EBIT-Marge sind neben Volumeneffekten aus dem höheren Umsatz insbesondere Effizienzsteigerungen bei internen Abläufen. Auch wird für das Segment Bonder in 2018 erneut ein deutlich positiver Ergebnisbeitrag erwartet. Für das Geschäftsjahr 2018 streben wir zudem wieder einen positiven Free Cashflow an.

Garching, im März 2018

Dr. Franz Richter
Vorstands-
vorsitzender

Robert Leurs
Finanzvorstand

Walter Braun
Produktions-
vorstand

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat möchte Sie, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, mit nachfolgendem Bericht über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 informieren.



Dr. Stefan Reineck, *Aufsichtsratsvorsitzender*

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat ist seinen gesetzlichen Verpflichtungen sowie den in Geschäftsordnung und Satzung verankerten Aufgaben im Jahr 2017 nachgekommen und hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und seine Tätigkeit überwacht. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Der Vorstand stimmte die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und unterrichtete ihn regelmäßig schriftlich und auch mündlich, zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte sowie die aktuelle Lage des Konzerns. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung wurden im Einzelnen erläutert und vom Aufsichtsrat anhand der erhaltenen Unterlagen und Informationen überprüft. Bedeutende Geschäftsvorgänge hat der Aufsichtsrat mit dem Vorstand ausführlich erörtert, zu zustimmungspflichtigen Geschäften hat der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilt. Im Geschäftsjahr 2017 fanden insgesamt sieben ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats statt.

Wie auch in den vorangegangenen Jahren stand der Aufsichtsratsvorsitzende über die Aufsichtsratssitzungen hinaus mit dem Vorstand in engem Kontakt und informierte sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle. Im ganz besonderen Fokus der Kommunikation stand dabei erneut die Entwicklung der bei der SUSS MicroTec Photonic Systems angesiedelten Produktlinie UV-Projektionsscanner. Darüber hinaus stand der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats im regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand und den Jahresabschlussprüfern, der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, zu Themen der Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung.

SITZUNGEN UND BERATUNGSSCHWERPUNKTE

Die Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die strategische Ausrichtung der SÜSS MicroTec SE, ihrer Tochtergesellschaften und des Konzerns wurden im Aufsichtsrat regelmäßig erörtert. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat umfassend über die Unternehmensplanung, die strategische Weichenstellung und die Entwicklung bei Auftragseingang, Umsatz, Liquidität und Ergebnis. Der Aufsichtsrat befasste sich darüber hinaus mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Im Folgenden wird auf die Schwerpunkte der Aufsichtsratssitzungen eingegangen.

Die erste ordentliche Aufsichtsratssitzung des Geschäftsjahres 2017 fand am 9. Februar 2017 statt. Hierbei befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Bericht des Vorstands zum vierten Quartal 2016, den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 sowie der Tagesordnung der Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat erörterte die Planung für das Geschäftsjahr 2017 sowie die Mehrjahresplanung 2017–2019. Darüber hinaus erörterte er die Ziele und den Bonusplan für den Vorstand für das Geschäftsjahr 2017. In dieser Sitzung diskutierte der Aufsichtsrat außerdem die Ziele und die Kriterien zur Besetzung des Aufsichtsrats und befasste sich mit dem Thema der geplanten Umwandlung der SÜSS MicroTec AG in die SÜSS MicroTec SE (Societas Europaea). Daneben führte der Aufsichtsrat seine Effizienzprüfung gemäß Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex durch und dokumentierte diese. Schließlich genehmigte der Aufsichtsrat die Investitionsplanung der SÜSS MicroOptics in der Schweiz.

An der zweiten Sitzung am 29. März 2017 nahmen Vertreter des Abschlussprüfers, der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, teil. Diese berichteten dem Aufsichtsrat über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016. Der Abschlussprüfer erläuterte dem Aufsichtsrat die Schwerpunkte der Einzel- und Konzernabschlussprüfung. Den Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 2016 und zur aktuellen Geschäftslage im ersten Quartal 2017 nahm der Aufsichtsrat zur Kenntnis. Der Aufsichtsrat billigte nach eingehender Prüfung den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2016. Darüber hinaus genehmigte der Aufsichtsrat die Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen für die Hauptversammlung am 31. Mai 2017. Schließlich befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Vorstandsbonus 2016 und erörterte die Ziele des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Aufsichtsratssitzung war die Festlegung von KPIs und Kennzahlen für die Steuerung des operativen Geschäfts (Operations).

Die dritte ordentliche Aufsichtsratssitzung fand am 3. Mai 2017 statt. Der Aufsichtsrat befasste sich mit der aktuellen Geschäftslage im ersten Quartal 2017 sowie dem Ausblick auf das Gesamtjahr 2017. Zudem diskutierte er eingehend über die an die SÜSS MicroTec Photonic Systems ausgereichten Intercompany-Darlehen und die damit verbundenen Risiken. Im Anschluss stimmte der Aufsichtsrat einem teilweisen Darlehensverzicht der SÜSS MicroTec AG gegenüber der SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. zu. Weitere Themen der Sitzung waren die strategische Ausrichtung sowie der Status und die Entwicklung bei der SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc.

In der vierten Sitzung am 31. Mai 2017, unmittelbar vor der ordentlichen Hauptversammlung, informierte der Vorstand den Aufsichtsrat über die aktuelle Geschäftslage. Zudem erörterte der Aufsichtsrat den Status und die Entwicklung der bei der SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. angesiedelten Produktlinien UV-Scanner und Laser-Stepper. Im zweiten Teil der Aufsichtsratssitzung, im Anschluss an die Hauptversammlung, fand die Konstituierung des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG sowie der SÜSS MicroTec SE statt. Darüber hinaus wurden die Vorstände der SÜSS MicroTec SE neu bestellt. Dabei tagte der Aufsichtsrat zum ersten Mal mit vier Mitgliedern und begrüßte die neu gewählte Frau Dr. Myriam Jahn, die einen Schwerpunkt zur Digitalisierung in das Gremium einbringt.

Am 9. August 2017 fand die fünfte ordentliche Sitzung des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2017 statt. Gegenstand der Sitzung waren unter anderem die aktuellen Geschäftszahlen des zweiten Quartals 2017 sowie der Ausblick für das Gesamtjahr 2017. In dieser Sitzung diskutierte der Aufsichtsrat erneut den Status der SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc., insbesondere wurde über den Status und das Potenzial des UV-Projektionsscanners DSC300 Gen3 diskutiert. Im Rahmen dieser Aufsichtsratssitzung stellte der Vorstand das Projekt SÜSS Academy zur Verbesserung der Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung sowie die Ergebnisse einer aktuellen Wettbewerbsanalyse vor. Der Aufsichtsrat wurde über den Status der Umwandlung in eine Societas Europaea informiert.

Am 12. Oktober 2017 wurde Herr Robert Leurs zum Vorstand der SÜSS MicroTec SE bestellt.

Am 8. November 2017 fand die sechste ordentliche Aufsichtsrats-sitzung des Geschäftsjahres 2017 statt. In dieser Sitzung berichtete der Vorstand über die aktuelle Geschäftslage im dritten Quartal sowie den Ausblick auf das Gesamtjahr 2017. Der Aufsichtsrat befasste sich mit der Aktualisierung der jährlichen Entsprechenserklärung nach § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex sowie der Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung der nichtfinanziellen Erklärung gemäß § 315b HGB. Zudem wurde das Thema Industrie 4.0 intensiv erörtert und es wurde die Verteilung der Vorstandsresorts ab dem 1. Dezember 2017 festgelegt. Der Vorstand stellte in dieser Sitzung darüber hinaus das SÜSS Excellence-Programm zur Verbesserung von Prozessen und Stärkung der Agilität der Organisation vor.

Gegenstand der letzten ordentlichen Sitzung des Geschäftsjahres 2017, die am 8. Dezember 2017 stattfand, waren die aktuelle Geschäftslage sowie die Planung für das Geschäftsjahr 2018. Weiterhin beschäftigte sich der Aufsichtsrat ausführlich mit der Corporate Governance und dabei insbesondere mit der Finalisierung der aktualisierten Entsprechenserklärung nach § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex, dem Thema Compliance sowie dem Fraud-Katalog der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Aufsichtsrat befasste sich mit dem Risikomanagement des Unternehmens und weiteren Vorstandsangelegenheiten. Es wurden zudem eine Änderung der Zeitkonten der SÜSS-Mitarbeiter sowie die aktuelle Situation der SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. diskutiert.

Soweit es erforderlich war, hat der Aufsichtsrat Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst.

Alle Aufsichtsratsmitglieder haben an sämtlichen Sitzungen und Beschlüssen teilgenommen.

Aufsichtsratsmitglied	Sitzungs- teilnahme	Persönlich anwesend	Anwesenheit
Dr. Stefan Reineck	7/7	7	100%
Jan Teichert	7/7	7	100%
Gerhard Pegam	7/7	7	100%
Dr. Myriam Jahn	4/4	4	100%

AUSSCHÜSSE

Ausschüsse hat der Aufsichtsrat aufgrund seiner Größe von vier Mitgliedern im Geschäftsjahr 2017 nicht gebildet.

CORPORATE GOVERNANCE

Der Aufsichtsrat befasste sich auch im Geschäftsjahr 2017 mit den Inhalten und der Umsetzung des Deutschen Corporate Governance Kodex. Informationen zur Corporate Governance im Unternehmen sowie der ausführliche Bericht zur Höhe und Struktur der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat sind im Abschnitt Vergütungsbericht des zusammengefassten Lageberichts auf den Seiten 83 ff. wiedergegeben. Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen im Januar 2017 die jährliche Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG und machten diese den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich.

In seiner Sitzung vom 9. Februar 2017 führte der Aufsichtsrat seine Effizienzprüfung gemäß Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex durch und dokumentierte diese. Dabei konnten keine Defizite festgestellt werden. Die Überprüfung der Effizienz der Aufsichtsrats-tätigkeit findet in regelmäßigen Abständen durch sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats einzeln im Plenum mit Unterstützung von unternehmensspezifischen Frage- und Checklisten statt.

Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber offenzulegen wären und über die die Hauptversammlung zu informieren wäre, lagen im Geschäftsjahr 2017 nicht vor.

JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNG

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, hat den nach den Vorschriften des HGB aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der SÜSS MicroTec SE zum 31. Dezember 2017 sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2017 geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss wurde gemäß § 315e HGB auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfungsberichte der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 26. März 2018 in Gegenwart des Abschlussprüfers umfassend behandelt. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung sowie darüber, dass keine wesentlichen Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems vorlägen. Insbesondere gab er Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns ab und stand dem Aufsichtsrat für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Der Abschlussprüfer ging ferner auf Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung ein. Schwerpunkte der diesjährigen Jahres- und Konzernabschlussprüfung bildeten das interne rechnungslegungsbezogene Kontroll- und IT-System sowie unter anderem die Beurteilung der Werthaltigkeit von Vorräten und Lieferforderungen, die Umsatzrealisation und die Beurteilung möglicher Risiken aus Planabweichungen und Margenverlusten in einzelnen Produktsegmenten. Als besonders bedeutsame Prüffelder (Key Audit Matters) wurden die Werthaltigkeitsprüfungen bei Firmen- und Geschäftswerten (Konzernabschluss) bzw. bei Finanzanlagen (Jahresabschluss) sowie die Bilanzierung eines Lizenzertrags aus einer Technologievermarktung festgelegt. Außerdem gehörten die Vollständigkeit und Korrektheit der Anhangsangaben, die Vollständigkeit und Angemessenheit der Lageberichterstattung sowie die Bewertung und Vollständigkeit der Rückstellungen zu den diesjährigen Prüfungsschwerpunkten.

Der Aufsichtsrat hat in der Bilanzsitzung am 26. März 2018 den Jahresabschluss der Gesellschaft und des Konzerns sowie den mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lagebericht der SÜSS MicroTec SE jeweils für das Geschäftsjahr 2017 geprüft. Der Aufsichtsrat hatte keine Einwände. Die Berichte des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat auch den Konzernabschluss gebilligt. Dem zusammengefassten Lagebericht für die SÜSS MicroTec SE und den Konzern und insbesondere der Beurteilung der weiteren Entwicklung des Unternehmens hat der Aufsichtsrat zugestimmt.

BESETZUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Im Geschäftsjahr 2017 gab es zwei personelle Änderungen im Vorstand. Der Aufsichtsrat berief am 12. Oktober 2017 Herrn Robert Leurs mit Wirkung zum 1. Dezember 2017 für die Dauer von drei Jahren zum Vorstand der SÜSS MicroTec SE. Herr Leurs löst damit Herrn Michael Knopp als Finanzvorstand ab, der sein Amt nach rund zehn Jahren im Unternehmen zum 30. April 2017 niederlegte. Daneben gehörten dem Vorstand im Geschäftsjahr 2017 weiterhin der Vorstandsvorsitzende Herr Dr. Franz Richter sowie der Produktionsvorstand Walter Braun an.

Auch im Aufsichtsrat gab es im Geschäftsjahr 2017 Veränderungen. Auf der Hauptversammlung 2017 wählten die Aktionäre die bestehenden drei Aufsichtsräte Herrn Dr. Stefan Reineck, Jan Teichert sowie Gerhard Pegam erneut für eine Periode von vier Jahren in den Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE, zudem wurde das Gremium um Frau Dr. Myriam Jahn erweitert und damit gehören dem Aufsicht nunmehr vier Mitglieder an.

DANK

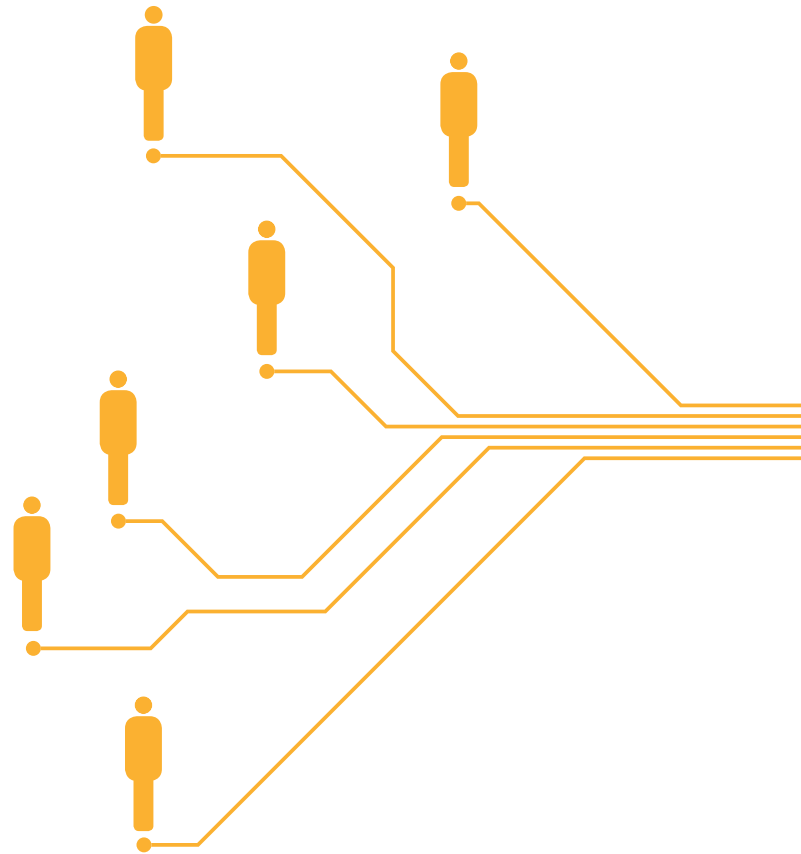
Der Aufsichtsrat spricht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Vorstand des Unternehmens großen Dank und Anerkennung für die ausgezeichnete Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr aus.

Garching, 27. März 2018

Dr. Stefan Reineck, Aufsichtsratsvorsitzender

**GEMEINSAM.
GROSSES.
SCHAFFEN.**

EIN TEAM BESTEHT AUS MEHREREN PERSONEN, DIE UNTERSCHIEDLICHE ERFAHRUNGEN UND FÄHIGKEITEN BESITZEN. BEIM ERREICHEN GEMEINSAMER ZIELE ERGÄNZEN UND UNTERSTÜTZEN SICH DIE TEAMMITGLIEDER GEGENSEITIG.



GEMEINSAM ERFOLGREICH



AUSGEPRÄGTE INNOVATIONSTÄRKE UND EIN STARKER FOKUS AUF FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG ZEICHNEN UNSER UNTERNEHMEN AUS.

Als Spezialmaschinenbauer, mit besonderem Fokus auf die Halbleiterindustrie, ist SÜSS MicroTec seit über 60 Jahren erfolgreich in schnelllebigem und wettbewerbsintensiven Märkten aktiv. Um den täglich steigenden Anforderungen gerecht zu werden und damit gegen internationale Wettbewerber bestehen zu können, braucht es Teams, die gemeinsam jede Herausforderung angehen und erfolgreich meistern.

In unserem mittelständisch geprägten Unternehmen gibt es nicht für jede Fragestellung eine vorgefertigte Lösung oder eine eigene Fachabteilung. Die Kollegen müssen sich gegenseitig unterstützen und profitieren so von ihren unterschiedlichen Fachkenntnissen und Erfahrungen. Ein reger Erfahrungsaustausch, auch abteilungs- und standortübergreifend, ist von entscheidender Bedeutung,

um effizient zu arbeiten und innovativ zu bleiben. Eine intensive Kommunikation sowie genaueste Abstimmungen zwischen den Kundenbetreuern in den lokalen Märkten Asiens und Nordamerikas sowie den Entwicklern in Europa sind Voraussetzung für die Erarbeitung bestmöglicher Lösungen für unsere Kunden.

SÜSS MicroTec hat die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in den letzten Jahren deutlich erhöht. Die kontinuierliche Verbesserung unserer bestehenden Produkte im Hinblick auf Bedienerfreundlichkeit und Funktionalität, Produktivität und Effizienz ist ein wichtiger Baustein der täglichen Arbeit. So konnten wir unseren Kunden in den letzten Jahren viele Produktinnovationen vorstellen.





BONDER

ERFOLGREICHER TURNAROUND: ZUM SEGMENT BONDER GEHÖREN DIE PRODUKTLINIEN PERMANENTE BONDSYSTEME FÜR ANWENDUNGEN IN DER MIKROSYSTEMTECHNIK UND TEMPORÄRE BONDSYSTEME FÜR ANWENDUNGEN IN DER 3D-CHIP-INTEGRATION (PACKAGING)

Tobias Barth
Mechanische und
pneumatische Konstruktion

Michael Ganning
Konstrukteur Mechanik R&D

Rainer Targus
Manager R&D Engineering
Bonder and Coater

Die Teams im Bereich Bonder haben in den vergangenen Jahren viel Zeit und Energie in die Neu- bzw. Weiterentwicklung der einzelnen Maschinen investiert.



Gemeinsam erarbeiten unsere Mitarbeiter stetig neue Lösungen und Prozesse.

Das Feedback unserer Kunden ist ein wichtiger Baustein für die stetige Verbesserung unserer Maschinen.



Applikationsreinräume

In unseren Applikationsreinräumen haben die Kunden die Möglichkeit, an Demonstrationsmaschinen mit den jeweiligen Projektteams zusammenzuarbeiten. Hierzu können sie auch eigene Wafer mitbringen und ihre Prozesse auf SÜSS MicroTec-Maschinen testen.

Der Bereich Bonder hat in unserem Unternehmen eine bewegte Historie vorzuweisen. Nach der Entwicklung der Bonder-Technologie in den 90er Jahren wurden die Maschinen zunächst am Standort Dresden und später in Garching gefertigt. Einige Jahre später erfolgte die Verlagerung der kompletten Produktlinie nach Waterbury, Vermont, USA. Im Jahr 2011 schließlich wurde die gesamte Produktion nach Sternenfels, Deutschland, zurückverlagert, wo sie heute neben den Produktlinien Belacker und Entwickler sowie dem Bereich Fotomaschinen-Equipment ansässig ist. Im Rahmen des Transfers von den USA nach Deutschland sind mehrere Mitarbeiter des US-Bonder-Teams mit nach Sternenfels gekommen, zudem gibt es in Williston, Vermont, ein Bonder Team für Forschungs- und Entwicklungsarbeit, das eng mit den Kollegen in Deutschland zusammenarbeitet.

Heute beinhaltet der Bereich die beiden Produktlinien permanente und temporäre Bondsysteme. In der Vergangenheit waren die Umsatzbeiträge aus den beiden Produktlinien nicht ausreichend, um insgesamt im Segment Bonder kostendeckend zu arbeiten. Im Geschäftsjahr 2013 wurde deshalb eine Refokussierung vorgenommen und die Fertigung der automatischen Bondsysteme eingestellt. Gleichzeitig wurde mit Hochdruck an der Entwicklung neuer Geräte gearbeitet.

Im Rahmen der Refokussierung wurde das Bonder-Team neu zusammengestellt und erweitert. Wenig später wurde mit der Entwicklung eines neuen, wettbewerbsfähigen automatischen Bondsystems begonnen. SÜSS MicroTec-Mitarbeiter und -Ingenieure aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Konstruktion sowie Softwarespezialisten und Experten aus dem Einkauf haben gemeinsam ein neues Gerät entwickelt und unseren Kunden im März 2017 vorgestellt. Das permanente Bondsystem XBS200 stößt bei den Kunden auf großes Interesse. Durch die erfolgreiche Refokussierung im Bereich permanente Bonder sowie durch nennenswerte Umsatzbeiträge aus dem Bereich temporäre Bonder konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals wieder ein positiver Ergebnisbeitrag erwirtschaftet werden.

Die temporären Bondsysteme kommen unter anderem während der 3D-Integration von Mikrochips zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um eine neuartige Technologie der Chip-Integration, die derzeit noch nicht in der Volumenproduktion der Halbleiterindustrie eingesetzt wird. Verschiedene Kunden investierten in der Vergangenheit bereits in einzelne Geräte zu Forschungs- und Entwicklungszwecken sowie in Pilotfertigungslinien. Im Geschäftsjahr 2017 erhielten wir mehrere Folgeaufträge von einem führenden asiatischen Halbleiterhersteller und konnten zudem neue Kunden aus Europa hinzugewinnen. Die ersten Maschinen dieses Folgeauftrags wurden bereits installiert und sind Teil des Bonder-Segmentumsatzes des Jahres 2017.

Bei der 3D-Integration werden gedünnte Mikrochips übereinandergestapelt und mit sogenannten TSVs (Through-Silicon Vias) miteinander verbunden. Das Handling der gedünnten Wafer wird durch Maschinen von SÜSS MicroTec unterstützt. Ein Wafer wird heute typischerweise auf rund 50 Mikrometer gedünnt und enthält trotzdem voll funktionsfähige Chips. Durch das Stapeln gedünnter Chips kann zum Beispiel in mobilen Endgeräten mehr Speicher auf geringem Raum platziert werden oder es können komplexe Packages verschiedener Chips integriert werden.

Wir stehen heute erst am Anfang der Überführung in die Volumenproduktion und sehen großes Potenzial für diesen Bereich. Dank des unermüdlichen Einsatzes unserer Teams im Bereich Bonder sind wir derzeit ein führender Anbieter, der diese Technologie für die Volumenfertigung von hochintegrierten Speicherchips anbieten kann.

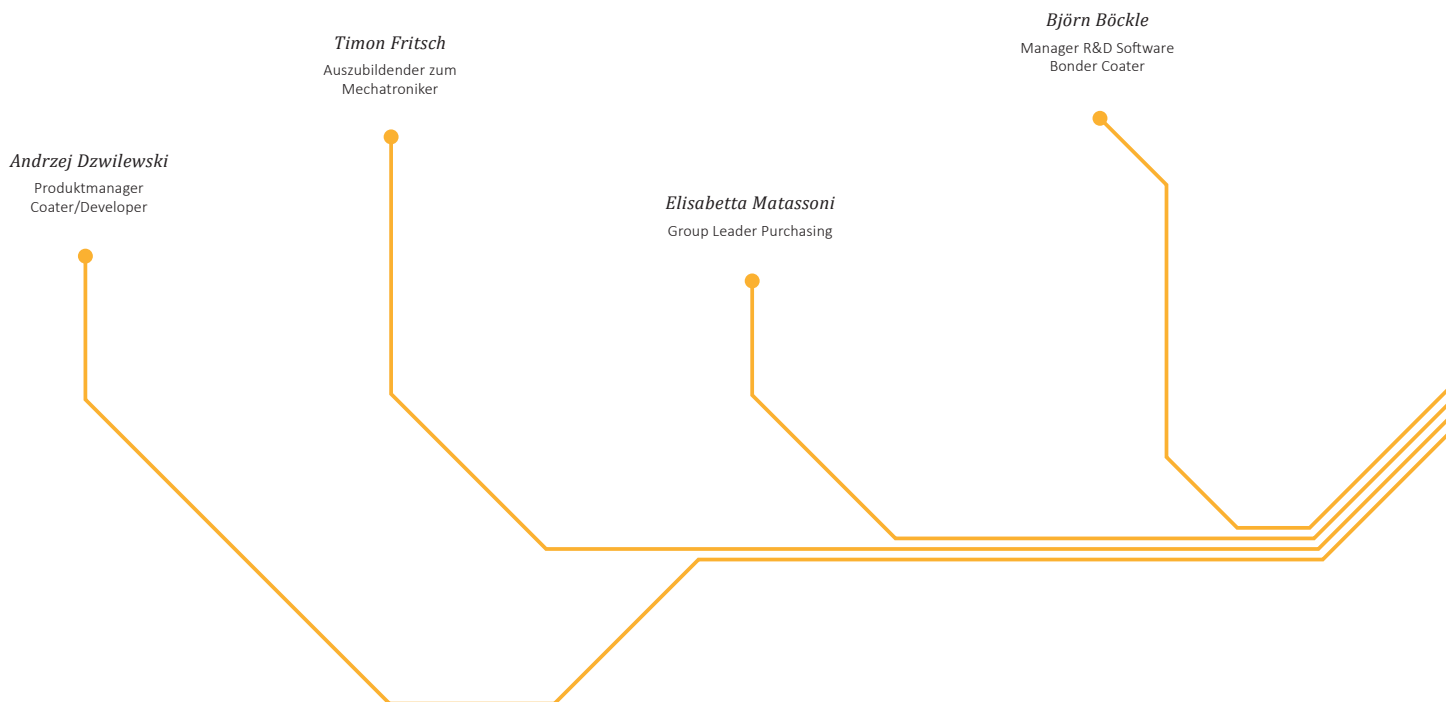


XBS200 ___ Mit der Entwicklung der XBS200-Plattform tritt SÜSS MicroTec in den attraktiven Markt für vollautomatische permanente Bondsysteme ein. Das Gerät basiert auf unserer erfolgreichen temporären Bonder-Plattform und wurde komplett auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden abgestimmt. Die XBS200 bietet hohen Durchsatz bei gleichzeitig geringem Platzbedarf, hohe Justage- und Wiederholgenauigkeit sowie eine ausgezeichnete Temperatur- und Bondkraftverteilung für eine maximale Ausbeute.



BELACKER UND ENTWICKLER

ZURÜCK ZU ALTER STÄRKE: SEIT EINIGEN JAHREN IST DIE PRODUKTLINIE BELACKER UND ENTWICKLER WIEDER DER UMSATZSTÄRKSTE BEREICH IM UNTERNEHMEN.



Unsere Spezialisten in der Produktlinie Belacker und Entwickler arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der Maschinen, um den steigenden Anforderungen der Kunden an Kosteneffizienz, Genauigkeit und Flexibilität gerecht zu werden. Derzeit besteht eine besonders hohe Nachfrage nach Geräten für die Bearbeitung von Wafern mit einem Durchmesser von 200 mm.



Im Rahmen des Verkaufsprozesses werden gemeinsam mit dem Kunden die Spezifikationen der Maschinen festgelegt.

Mit viel Erfahrung und technischem Know-how werden unsere Geräte entwickelt, konstruiert und gebaut.



ACS200 Gen3 __ Die unübertroffene Flexibilität bei der Konfiguration von Modulen und Technologien der ACS200 Gen3 erfüllt nicht nur die Anforderungen der Bereiche Advanced Packaging, MEMS und LED, sondern bildet auch eine Brücke zwischen F&E und der Massenfertigung. Mit einer umfassenden Produktpalette, die vom preiswerten Laborgerät bis hin zur hochleistungsfähigen Produktionsanlage für 300-mm-Wafer reicht, ermöglichen die Belacker und Entwickler von SÜSS MicroTec das Aufbringen und Strukturieren von Fotolackschichten von unter 1 μm bis über 500 μm .



Angefangen bei der Konstruktion, über den Einkauf der einzelnen Komponenten bis hin zur Montage und Inbetriebnahme arbeiten die Projektteams im Bereich Belacker und Entwickler Hand in Hand. Ständig steigende Forderungen nach mehr Funktionalität bei gleichzeitig stabilen oder eher sinkenden Preisen macht eine stetige Verbesserung der Effizienz unserer Organisation unabdingbar. Optimierte Informationsflüsse zwischen den Abteilungen wie auch stetiger Austausch mit den Kunden, um punktgenau deren Erwartungen zu erfüllen, ist die Basis unserer Zusammenarbeit.

Die Umsätze mit Maschinen, die Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm bearbeiten können, entwickelten sich in den letzten Jahren sehr gut. Die Nachfrage kommt aus den Endmärkten mobile Kommunikation, Internet der Dinge, der Automobilbranche sowie der Konsumelektronik. Hierbei werden insbesondere die Anwendungsbereiche Advanced Packaging, BAW- und SAW-Filter (Oberflächenwellenfilter) sowie MEMS (mikro-elektromechanische Systeme) stark nachgefragt. Die Datenmenge, die gemessen, analysiert und gespeichert werden muss, nimmt stetig zu. Damit steigt auch der Bedarf an Sensoren, Aktuatoren sowie Speicherbausteinen und anderen elektronischen Bauelementen, die teilweise auf sehr engem Raum unterzubringen sind. Neben der steigenden Funktionalität spielen Gerätegröße und Energieverbrauch heute eine entscheidende Rolle, siehe Smartphones. Durch moderne Packaging-Methoden können immer mehr Funktionen in immer kleiner werdende Geräte bei sinkendem Energieverbrauch untergebracht werden.

In dem sehr dynamischen und von enorm hohen Investitionen geprägten Marktumfeld müssen die Kunden ihre Kapazitäten stetig ausweiten, um die steigende Nachfrage zu befriedigen. Durch die stark gestiegene Bedeutung der Formfaktoren hat sich in den letzten Jahren die Wertschöpfung vom Frontend der Halbleiterindustrie zu Gunsten des Mid- und Backend verlagert. Ohne moderne Packaging-Technologien gäbe es heute keine schlanken Smartphones, Tablets oder vergleichbare Geräte wie beispielsweise Smartwatches oder Fitness-Armbänder.

Als führender Halbleiter-Equipment-Hersteller, der sich neben dem Fotomasken-Equipment für das Frontend vor allem auf Anwendungen im Mid- und Backend fokussiert, verzeichnete SÜSS MicroTec in den vergangenen Jahren einen deutlichen Zuwachs an hochvolumigen Orders internationaler Kunden. Die bestellten Stückzahlen und damit das Auftragseingangsvolumen einzelner Kundenorders haben sich gegenüber der Vergangenheit zum Teil deutlich erhöht. SÜSS MicroTec reagiert auf diese Herausforderung mit dem Aufbau entsprechender Mitarbeiterstrukturen und arbeitet im Rahmen von langfristigen und partnerschaftlichen Outsourcing-Vereinbarungen zunehmend auch mit anderen Subunternehmen zusammen. Damit stellen wir die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte auch bei höheren Stückzahlen und bei gleichzeitig fristgerechter Fertigung und Auslieferung sicher.

EIN PROGRAMM FÜR KUNDEN UND MITARBEITER – SÜSS EXCELLENCE



Saskia Hanauer
Referentin des COO



Annette Schmid
Personalreferentin
Aus- und Weiterbildung

EFFIZIENZ STEIGERN, FLEXIBILITÄT FÖRDERN UND GLEICHZEITIG EIN ATTRAKTIVES ARBEITSUMFELD BIETEN

SÜSS MicroTec ist in hochinnovativen und -dynamischen Märkten aktiv. Um stets die beste Lösung für unsere Kunden zu entwickeln und gleichzeitig unsere Mitarbeiter zu fördern und zu fordern, wurde das SÜSS Excellence-Programm ins Leben gerufen. Das Programm hat seine Schwerpunktthemen in den Bereichen Prozessoptimierung und Kommunikation sowie Weiterbildung und Training bzw. Förderung einer offenen Unternehmenskultur.

Prozesse kritisch prüfen, Abläufe entschlacken, Kommunikation verbessern, Mitarbeiter fördern und Kundennutzen optimieren, das sind die Ziele des Ende 2017 gestarteten SÜSS Excellence-Programms. Kurze Entscheidungswege, präzise Kommunikation und die Übernahme von Verantwortung durch jeden einzelnen Mitarbeiter sind maßgebliche Faktoren für einen erfolgreichen Geschäftsverlauf sowie zufriedene Kunden und Mitarbeiter.



Stefanie Mezger
Program Manager
Corporate Culture

Ulrike Schömb
Manager SÜSS Training Center

Dirk Bergner
Director Business Process
Management

Prozessoptimierung

Dirk Bergner

Dies bedeutet die kontinuierliche Überprüfung und Anpassung unserer Geschäftsabläufe im Hinblick auf die Anforderungen unserer Kunden.



Weiterbildung

Annette Schmid

Die Herausforderungen unseres Marktes können wir nur mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitern stemmen.



Technisches Training

Ulrike Schömbis

Das neue SÜSS Training Center Konzept deckt weltweit alle technischen Trainings für SÜSS MicroTec-Produkte ab.



5S

Saskia Hanauer

Mit der 5S-Methodik verfolgen wir das Ziel, durch eine strukturierte Organisation des Arbeitsplatzes nicht wertschöpfende Tätigkeiten zu minimieren.



SÜSS Excellence-Programm

Bereits seit Herbst 2016 veranstaltet das Unternehmen Vorstandsgesprächsrunden an den deutschen Standorten, in denen sich der Vorstand Zeit für aktuelle Themen und Mitarbeiterbelange nimmt. Kollegen aller Abteilungen erhielten und erhalten in diesen Runden Gelegenheit, ihr Wort direkt an den Vorstand zu richten. Das vom SÜSS MicroTec-Management ins Leben gerufene Programm „SÜSS Excellence“ soll die Kunden und Mitarbeiter nun noch mehr in den Mittelpunkt rücken. Das SÜSS Excellence-Programm mit seinen Themenschwerpunkten aus den Bereichen Personal, Prozessoptimierung und Kommunikation soll durch gezielte Maßnahmen in verschiedensten Bereichen die Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter weiter erhöhen. Das Ganze ist eingebettet in die Gestaltung der Unternehmenskultur.



Unternehmenskultur

Stefanie Mezger

Leitlinien und gemeinsame Werte bieten Orientierung im Umgang mit Kollegen und Geschäftspartnern und stärken die Identifikation mit SÜSS MicroTec.



SÜSS MicroTec-Produkte __ Die SÜSS MicroTec-Gruppe entwickelt und fertigt Anlagen sowie Prozesslösungen für Mikrostruktur-anwendungen – ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über mehr als sechzig Jahre Erfahrung verfügt. Unsere Produktpalette umfasst Equipment für Anwendungen der Halbleiterindustrie und verwandter Branchen. Unsere Qualitätsgarantie erstreckt sich auch auf unsere gebrauchten Maschinen und unseren Service.

Wir bieten individuell zugeschnittene Produkte für unsere Kunden, die auf uns zählen, da sie von uns eine hohe Qualität erwarten können. Um diesem Anspruch nachhaltig gerecht zu werden, analysieren und optimieren wir permanent unsere Fertigungsprozesse. Von der Auftragserteilung bis zur Auslieferung an den Kunden gibt es in der Regel einen engen Zeitplan. Wenn es zu Beginn eines Projekts bereits Verzögerungen gibt, überträgt sich dies unweigerlich auf die letzten Glieder in der Fertigungskette. Dies zu erkennen, wiederkehrende Fehlerquellen zu beheben und nachhaltig effizienter zu werden sind Ziele im Bereich Prozessoptimierung und 5S. Dadurch werden wir die Kunden-, aber auch die Mitarbeiterzufriedenheit deutlich steigern.

Eine offene und zielgerichtete Kommunikation, ein wertschätzender Umgang miteinander, die Förderung von Weiterbildung sowie die Übernahme von Verantwortung sind unsere gemeinsamen Werte. Sie bilden die Basis unserer Unternehmenskultur, die von unseren Mitarbeitern verinnerlicht und gelebt wird. Im Bereich Weiterbildung gilt es, die Fach-, Methoden-, Sozial- und Führungskompetenz zu stärken und auszubauen. Daneben sind Themen wie Nachfolgeregelungen und Talentförderung weitere Bausteine des Programms. Für das SÜSS Training Center wurden die Trainer-Teams in Garching und Sternenfels personell verstärkt. Diese Teams werden ein gemeinsames und produktübergreifendes Konzept für interne und externe Trainings aufsetzen und die entsprechenden Schulungen und Dokumente erarbeiten.

Der Bereich Fotomaschinen-Equipment ist der einzige Bereich, in dem SÜSS MicroTec im Frontend der Halbleiterindustrie tätig ist. Mit unseren Lösungen zur Reinigung von Fotomaschinen unterstützen wir den Trend zur Strukturverkleinerung, auch bekannt unter dem Begriff „Moore’s Law“.



FOTOMASKEN-EQUIPMENT

MARKTFÜHRER DURCH INNOVATIONEN FÜR DAS FRONTEND DER HALBLEITERINDUSTRIE



MaskTrack Pro __ Für das Gelingen von hochanspruchsvollen lithografischen Prozessen spielt die Unversehrtheit der Fotomaske eine große Rolle. Der MaskTrack Pro erfüllt alle Kriterien der nächsten Stufe der Lithografie-Roadmap im Hinblick auf Reinigungs-, Ausheiz- und Entwicklungsprozesse von Fotomasken.

Unsere größten Maschinen gehören zum Segment Fotomasken-Equipment. Mit diesen hochkomplexen Geräten können Fotomasken, die für Lithografieverfahren im Frontend der Halbleiterindustrie eingesetzt werden, gereinigt werden. Die Maske wird regelmäßig durch komplexe physikalische und chemische Prozesse von Verunreinigungen und kleinsten Partikeln befreit, bevor sie erneut im Produktionsprozess im Frontend eingesetzt wird. SÜSS MicroTec hat als einziges Unternehmen weltweit die Qualifikation, Fotomasken zu reinigen, die Strukturen von nur noch sieben Nanometern aufweisen. In diesem Nischenmarkt, mit einem Marktvolumen von durchschnittlich ca. 20 bis 30 Millionen Euro, liegt unser Marktanteil nach eigenen Schätzungen bei rund 80 Prozent.

Der Markt für Fotomaskenreinigung ist durch die Entwicklung im Frontend der Halbleiterindustrie bestimmt. Sobald neue Lithografieverfahren wie beispielsweise die EUV-Lithografie (Extreme Ultra Violet) oder eine weitere Strukturverkleinerung stattgefunden haben, müssen die Technologien zur Reinigung von Fotomasken angepasst oder gegebenenfalls ausgetauscht werden. In der Regel bleiben die bestehenden Anlagen weiter in Betrieb, da der Markt kontinuierlich wächst und stetig zusätzliche Kapazitäten benötigt werden.



MASK-ALIGNER

PRÄZISION MADE IN GERMANY: SÜSS MICROTEC
FERTIGT SEIT MEHR ALS 60 JAHREN MASK-ALIGNER
AM STANDORT GARCHING BEI MÜNCHEN.

Dr. Omar Fakhr
Applikationsingenieur

Liming Chai
Applikationsingenieurin

Harald Anderl
Quality Assurance Engineer

Petra Nuschele
Leiterin Montage

Ausgezeichnete Qualität bei gleichzeitig hohem Durchsatz und Kosteneffizienz, dies zeichnet unsere Mask-Aligner seit vielen Jahren aus. In Volumen Anwendungen mit einer Auflösung von bis zu fünf Mikrometern ist der Mask-Aligner im Bereich Belichtung das am häufigsten eingesetzte Gerät im Halbleiter-Mid- und -Backend.

Langjährige Erfahrung, eine ausgeprägte Branchenkenntnis sowie die Fähigkeit der Kollegen in den Mask-Aligner-Teams, sich verändernden Marktgegebenheiten zügig anzupassen – dies sind die Gründe für den Erfolg der Produktlinie über die letzten Jahrzehnte. Um das Wissen im Unternehmen zu halten, geben erfahrene Kollegen ihr Wissen an junge Kollegen und neue Mitarbeiter weiter. Zudem finden im Rahmen des SÜSS Excellence-Programms verstärkt Schulungen für Mitarbeiter und Kunden statt.

Mask-Aligner sind Belichtungsgeräte, die mittels Schattenwurfverfahren die Struktur einer Maske auf einen Wafer übertragen. Mask-Aligner kommen zum Beispiel bei der Herstellung von MEMS und LEDs sowie beim Advanced Packaging zum Einsatz. Strukturgrößen von einigen 10 Mikrometern bis hinunter zu fünf Mikrometern können mittels der Mask-Aligner-Technologie kostengünstig und in hoher Qualität hergestellt werden. Auch in dieser Produktlinie unterscheiden wir zwischen manuellen Geräten für den Einsatz im Labor bzw. im Forschungsumfeld und vollautomatischen Geräten für die Volumenproduktion.

Unsere Applikationsingenieure arbeiten eng mit den Kollegen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung zusammen, um für den Kunden die bestmöglichen Lösungen und Prozesse zu entwickeln. Schnelle Lieferzeiten und kundenspezifische Lösungen sind die Spezialität dieses Segments.

Am Standort Garching entwickeln, konstruieren und montieren wir die Produktlinie Mask-Aligner.





Hohe Präzision, gepaart mit schnellen Durchlaufzeiten und günstigen Anschaffungskosten – diese „Cost of Ownership“-Prämissen sind für den Kunden von größter Bedeutung.

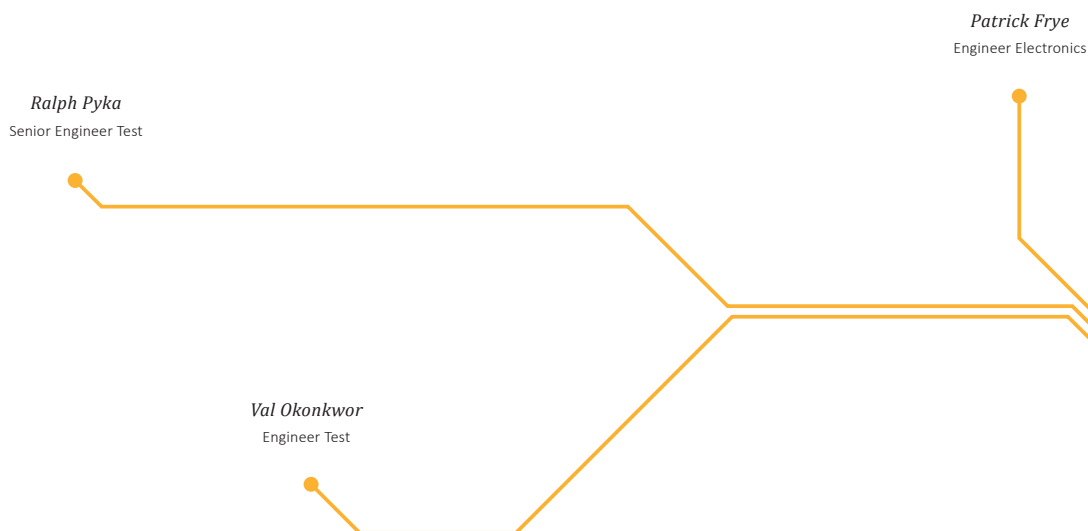


MA200 Gen3 __ Der MA200-Gen3-Mask-Aligner eignet sich aufgrund seiner für die Großserienfertigung ausgelegten Konzeption für die automatisierte Verarbeitung von Wafern und eckigen Substraten bis zu einer Größe von 200 mm. Das System vereint Vollfeldlithografie mit einer Reihe innovativer Funktionalitäten. Dadurch ist die Maschine ideal für eine Vielzahl von Anwendungen ausgestattet wie der Herstellung von MEMS in Dicklack-Prozessen, 3D-Strukturierung auf erhöhter Topografie sowie Anwendungen im Bereich Advanced Packaging, zum Beispiel 3D-Packaging, Fan-out oder Bumping.



UV-PROJEKTIONS-SCANNER

ZUKUNFTSPOTENZIAL: DIE VIELVERSPRECHENDE UV-PROJEKTIONSTECHNOLOGIE HABEN WIR IM JAHR 2012 MIT DER ÜBERNAHME DER DAMALIGEN TAMARACK SCIENTIFIC IN CORONA, USA, ERWORBEN.



Mitte 2018 wird eine neue Produktgeneration der UV-Projektionsscanner auf den Markt kommen, die bereits heute das Kundeninteresse weckt. Zuvor stehen den Kunden Upgrade-Kits für bestehende Systeme zur Verfügung, die die Leistungsfähigkeit der aktuellen Produktgeneration deutlich verbessern.

Beim Projektionsscannen wird eine Vollfeldmaske über dem Substrat justiert und durch einen Scan-Vorgang der abbildenden Optik auf das Substrat projiziert. Verglichen mit Steppern erreicht die Scan-Technologie einen höheren Durchsatz bei geringeren Systemkosten und einer vergleichbaren Auflösung.

Im vergangenen Geschäftsjahr haben die Ingenieure bei SUSS MicroTec Photonic Systems erfolgreich eine neue Generation der DSC300 konzipiert und entwickelt. Die neue Maschinengeneration wird gegenüber dem Vorgängermodell eine höhere Auflösung sowie einen deutlich erhöhten Durchsatz aufweisen. Kern der Neuerungen ist eine optische Anpassung (Vergrößerung bzw. Verkleinerung) des Projektionsbildes, um die besonders im Fan-out-Wafer-Level-Packaging-Prozess auftretenden Verschiebungen der Chips kompensieren zu können. Durch Verwendung einer neuartigen Waferstage wird die DSC300 Gen3 ein Overlay im Sub- μm -Bereich erreichen, und damit vergleichbare Werte wie ein UV-Projektionsstepper.

Das derzeit interessanteste Anwendungsfeld für unsere Scanner ist das Advanced Packaging, speziell der Bereich Fan-out-Wafer-Level-Packaging (FOWLP). Gemäß dem Fraunhofer IZM ist das FOWLP einer der neuesten Packaging-Trends in der Mikroelektronik. Die technologische Basis des FOWLP ist ein künstlich zusammengestellter Wafer mit eingebetteten Mikrochips und einer Dünnfilm-Umverdrahtungslage. Die Hauptvorteile des FOWLP sind ein sehr dünnes, weil substratloses Package sowie der geringe thermische Widerstand.

In diesem Bereich konnten wir 2015 den ersten Volumenauftrag eines internationalen Halbleiterherstellers gewinnen. Die Auslieferung der Maschinen erfolgte im Geschäftsjahr 2016, seither sind die Maschinen im steten operativen Einsatz. Mit der Einführung des Upgrade-Kits für bestehende Maschinen und der Markteinführung der neuen Produktgeneration erhoffen wir uns ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2018 Aufträge für diese neue Maschinengeneration. Hierzu werden ab Jahresmitte 2018 Demonstrations- und Evaluierungsgeräte für unsere Kunden zur Verfügung stehen.

Der Bereich Projektionslithografie wurde mit der Akquisition der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. (vormals Tamarack Scientific) unter das Dach der SÜSS Produktfamilie geholt.



Wafer-Level-Packaging (WLP)

WLP beschreibt das gesamte Technologiespektrum für die Aufbau- und Verbindungstechnik, die eine Direktmontage des Mikrochips auf die Leiterplatte ermöglicht. Im Unterschied zum reinen Wafer-Bumping sind hierzu zusätzliche Verdrahtungsebenen notwendig, die aber auch das Potenzial für eine höhere Integrationsdichte bieten, wie die Integration von passiven oder aktiven Bauteilen.

(Quelle: Fraunhofer IZM)



Unsere neuartigen UV-Projektions-scanner vereinen die Vorteile der Vollfeldbelichtung mit denen der klassischen Projektionslithografie.



DSC300 __ Der Projektionsscanner DSC300 Gen2 verarbeitet Wafer von Größen bis zu 300 mm unter Nutzung modernster Verfahren der Projektionslithografie. Die Anlage bedient die Anforderungen von Wafer-Level-Packaging, 3D-Packaging sowie Bumping-Anwendungen und bietet eine ideale Lösung für neu entstehende Packaging-Anwendungen wie CU-Pillar-Bumping und Fan-out-Wafer-Level-Packaging.

SCHWEIZER HIGHTECH



DIE SUSS MICROOPTICS HAT SICH VOM START-UP ZUM FÜHRENDEN HERSTELLER VON HOCHWERTIGEN MIKRO-OPTIKEN UND MIKRO-OPTISCHEN SYSTEMEN ETABLIERT.

Die Herstellung von Mikro-Optiken mittels Verfahren der Halbleitertechnik wurde in den 1990er Jahren in staatlich geförderten Forschungsprojekten in Deutschland, der Schweiz und den USA zur Industriereife entwickelt. 1999 schlossen sich die Süss MicroTec Lithographie (SMTL) und drei Mikro-Optik-Experten der Universitäten Neuchâtel (Schweiz) und Erlangen-Nürnberg (Deutschland) zusammen und gründeten die SUSS MicroOptics. Das Joint-Venture sollte ursprünglich nur Mikro-Optiken für Mask-Aligner von SÜSS MicroTec entwickeln. Aus dem kleinen Start-up ist heute ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Mikro-Optiken mit über 200 Kunden geworden.

Im Jahr 2012 zog das Schweizer Unternehmen in sein jetziges Gebäude mit einem hochmodernen Reinraum. Hier fertigt die SUSS MicroOptics kundenspezifische monolithische Mikro-Optiken auf Wafer-Ebene in Silizium und Quarzglas. Hochtechnologien der Halbleiterindustrie wie Mikrostrukturierung im Sub-Mikron-Bereich, Beschichtungs-, Ätz- und Imprint-Verfahren, Wafer-Level-Packaging (WLP), Wafer-Trennverfahren (Dicing) und vollautomatische Inspektions- und Sortiersysteme kommen hier zum Einsatz. Ein internationales Team von Ingenieuren und Wissenschaftlern entwickelt gemeinsam mit den Kunden innovative Lösungen. Die refraktiven und diffraktiven Mikro-Optiken der SUSS MicroOptics sind heute wichtige Schlüsselemente für viele medizinische Geräte, für Messinstrumente, sie finden sich in Glasfasernetzen, in Forschungssatelliten, in Autos und vielen anderen Produkten. Das schnelle Wachstum des Photonik-Marktes erfordert ein unermüdliches Verbessern der Technologie, die Erschließung neuer Märkte und die Entwicklung neuer Anwendungen.



INVESTOR RELATIONS

Für viele Kapitalanleger war das Börsenjahr 2017 sehr erfreulich. Der deutsche Leitindex DAX erreichte einen Rekordwert nach dem anderen und konnte das Börsenjahr am 29.12.2017 bei einem Stand von 12.918 Punkten beenden, nachdem er im Januar 2017 noch in einer gewissen Bandbreite um die 10.500 Punkte notiert hatte. Gleiches gilt für den US-amerikanischen Leitindex Dow Jones, auch er hat im Jahresverlauf 2017 einen neuen Höchstwert von über 24.700 Punkten erreicht. Die weltweiten Konjunkturaussichten sind überwiegend positiv, dies spiegelt sich entsprechend auch an den Aktienmärkten wider. Zudem gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr zunehmend Bewegung am IPO-Markt – in diesem freundlichen Umfeld wagen sich wieder vermehrt Unternehmen an die Börse.

DIE SÜSS MICROTEC-AKTIE

Die SÜSS MicroTec-Aktie entwickelte sich im ersten Quartal 2017 sehr gut und konnte gegenüber dem XETRA-Schlusskurs von 6,54 Euro zum Jahresanfang 2017 um 33,0 Prozent auf 8,70 Euro am 31. März 2017 zulegen. Die Gründe hierfür lagen zum einen in der guten Geschäftsentwicklung von SÜSS MicroTec und zum anderen in den positiven Brancheneinschätzungen verschiedener Marktforschungsinstitute, wie Gartner oder Semi.

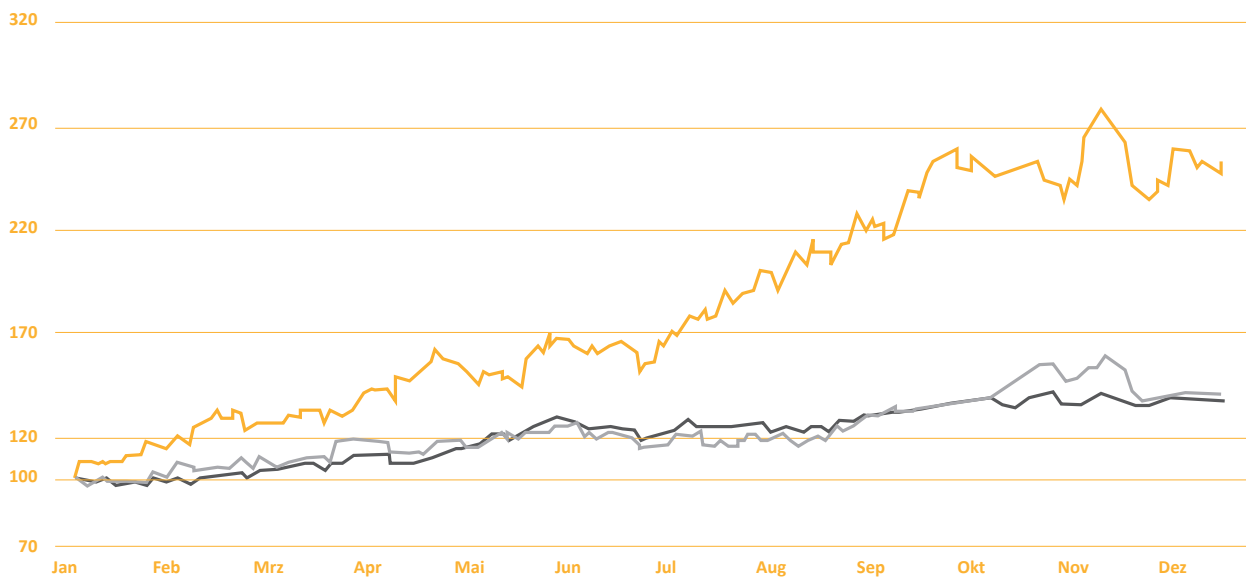
Die positive Kursentwicklung hat sich im zweiten Quartal mit unverminderter Geschwindigkeit fortgesetzt. Unsere Aktie durchbrach die 10-Euro-Grenze im April und konnte sich bis zum Juli auf zwischenzeitlich knapp über 12 Euro steigern. Der Schlusskurs am 30. Juni 2017 lag bei 10,29 Euro, ein Plus von rund 57 Prozent gegenüber Jahresanfang. Auch der Vergleichsindex TecDAX hat sich in der ersten Jahreshälfte durchweg positiv entwickelt, konnte aber im direkten Vergleich nicht mit der erheblichen Kurssteigerung von SÜSS MicroTec mithalten. Gleiches gilt für den deutschen Halbleiter-Subindex der Deutschen Börse – den Prime IG Semiconductor. Dieser Index legte im ersten Halbjahr 2017 um 14 Prozent zu, während der TecDAX ein Plus von 19 Prozent verzeichnete.

Am 29. September, dem letzten Börsenhandelstag des dritten Quartals, schloss unsere Aktie bei 16,76 Euro, was einem Zuwachs gegenüber Jahresanfang um mehr als 150 Prozent entspricht. Im Verlauf des dritten Quartals erreichte die Aktie Kurse von über 17 Euro. Die Gründe hierfür waren der gute Ausblick unseres Unternehmens auf die Bereiche Bonder und UV-Projektionscanner sowie ein starkes Marktumfeld. Zudem hatten die Branchenkenner von Gartner ihre Erwartungen für das Wachstum im Halbleitermarkt im Jahresverlauf erneut erhöht und erwarteten für 2017 und fortgeführt in 2018 neue Rekordumsätze in der Branche.

Die gute Stimmung am Kapitalmarkt und somit auch die positive Kursentwicklung der SÜSS MicroTec-Aktie haben sich im vierten Quartal des Jahres 2017 fortgesetzt. Unbeeindruckt von geopolitischen Spannungen haben die Leitindizes der internationalen Aktienmärkte erneut Höchststände verzeichnen können. Die SÜSS MicroTec-Aktie legte nach einer rasanten Entwicklung im Oktober und Anfang November eine Verschnaufpause ein. Der Kurs stabilisierte sich bei Werten um die 15 bis 16 Euro. Im November, nach Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal und nach Bekanntgabe der Erwartungen für das vierte Quartal 2017, hat sich die Aktie zunächst seitwärts entwickelt. Nach der Anhebung der Erwartungen für das vierte Quartal konnte die Aktie erneut zulegen. Die SÜSS MicroTec-Aktie schloss das Börsenjahr am 31.12.2017 mit einem XETRA-Schlusskurs von 16,64 Euro, was einem Plus gegenüber Jahresbeginn von rund 160 Prozent entspricht. Der TecDAX sowie der Prime IG Semiconductor konnten im Jahresverlauf 2017 um 39,6 Prozent beziehungsweise um 48,0 Prozent zulegen.

Die Anzahl der im Tagesdurchschnitt an den deutschen Börsenplätzen XETRA und Frankfurt gehandelten SÜSS MicroTec-Aktien lag im Geschäftsjahr 2017 bei rund 120 Tsd. Stück (2016: durchschnittlich rund 168 Tsd. Aktien pro Tag).

KURSENTWICKLUNG DER SÜSS MICROTREC-AKTIE IM JAHR 2017



XETRA-Schlusskurs der SÜSS MicroTec-Aktie am 2. Januar 2017: 6,54 €

- SÜSS MicroTec SE, indiziert
- TecDAX, indiziert
- Prime IG Semiconductor, indiziert

VERGLEICH DER KURSENTWICKLUNG VON SÜSS MICROTEC UND TECDAX IM GESCHÄFTSJAHR 2017

	29.12.2017	30.12.2016	Veränderung
TecDAX (in Punkten)	2.529,04	1.811,72	+39,6%
SÜSS MicroTec (in €)	16,64	6,40	+160%

DIE SÜSS MICROTEC-AKTIE IM ÜBERBLICK

Wertpapierkennnummer	A1K023
ISIN	DE000A1K0235
Reuters-Kürzel	SMHN
Bloomberg-Kürzel	SMHN:GR
Börsensegment	Prime Standard
Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stand 31.12.2017)	19.115.538
Wertpapiergattung	Namensaktien
Designated Sponsor zum 31.12.2017	equinet Bank AG
Beginn der Börsennotierung	18.05.1999
Jahresanfangs-/schlusskurs in €	6,54 €/16,64 €
Jahreshoch-/tief in € ¹	18,29 €/6,54 €

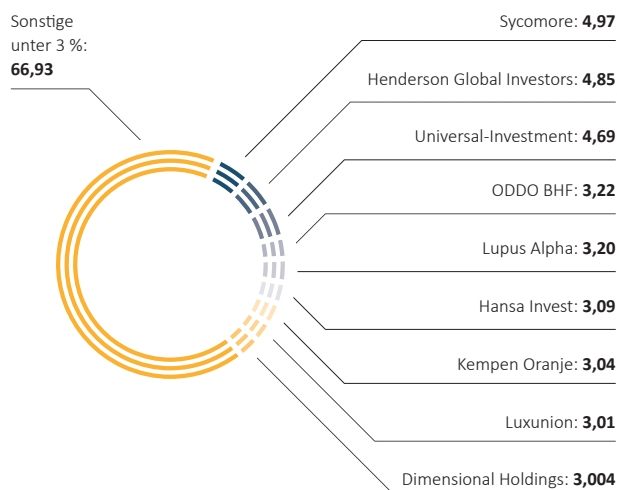
¹ Xetra-Schlusskurs.

INVESTOR RELATIONS-AKTIVITÄTEN

Investor Relations umfasst alle Maßnahmen, die der Pflege der Beziehungen eines börsennotierten Unternehmens zu den Investoren dienen. Es geht bei der Investor Relations-Arbeit unter anderem darum, den Kapitalmarkt zeitnah mit aktuellen Informationen über das Unternehmen zu versorgen und somit eine angemessene Bewertung der Aktie an der Börse zu gewährleisten. Zu den Kapitalmarktteilnehmern und damit zu den direkten Ansprechpartnern gehören Privataktionäre, Fondsmanager, Finanzanalysten in Bankhäusern und natürlich auch die Finanzpresse.

Vorstand und Investor Relations besuchten im Börsenjahr 2017 acht Kapitalmarktkonferenzen und absolvierten mehrere Roadshows. Die Kapitalmarktkonferenzen fanden in München, Frankfurt und Berlin statt. Zusätzlich dazu wurde in vielen Einzelgesprächen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit institutionellen Investoren und Analysten genutzt. Anlässlich der Veröffentlichung von Quartalsergebnissen fanden Telefonkonferenzen für Investoren und Analysten statt.

Im Jahr 2017 gab es einige wesentliche Veränderungen in der Aktionärsstruktur. Die gemeldeten Bestände bei den bestehenden Fondsgesellschaften haben unterjährig leicht geschwankt, aber es gab keine großen Veränderungen. Neu hinzugekommen sind folgende Aktionäre: Luxunion mit 3,01 Prozent, ODDO BHF mit 3,22 Prozent, Hansa Invest mit 3,09 Prozent sowie Kempen Oranje mit 3,04 Prozent. Der Streubesitz beträgt zum Jahresende 2017 weiterhin 100 Prozent.

AKTIONÄRSSTRUKTUR ZUM 31. DEZEMBER 2017 in %


ANALYSTENEMPFEHLUNGEN WEITERHIN POSITIV

Zum Jahresende 2017 wurde das Unternehmen von insgesamt sieben Banken und Research-Häusern aktiv gecovered. Stand Dezember 2017 haben drei Analysten eine Kaufempfehlung für die SÜSS MicroTec-Aktie ausgesprochen, daneben gaben drei Analysten die Empfehlung zum Halten der Aktie. Ein Analyst stuft die Aktie zum Verkauf ein. Eine Übersicht über die Research-Studien zur SÜSS MicroTec-Aktie finden Sie im Internet unter > www.suss.com > *Investor Relations*.

HAUPTVERSAMMLUNG

Am 31. Mai 2017 fand die ordentliche Hauptversammlung im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München statt. Insgesamt waren über 80 Aktionäre, Aktionärs- und Bankenvertreter sowie Gäste der Einladung des Unternehmens nach München gefolgt. Damit waren 26,23 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft anwesend. Neben der Entscheidung über die Entlastung des Vorstands sowie des Aufsichtsrats wurde über die Bestellung des Abschlussprüfers und über die Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) abgestimmt. Zudem standen in diesem Jahr Wahlen zum Aufsichtsrat auf der Tagesordnung. Der Aufsichtsrat von SÜSS MicroTec besteht nunmehr aus vier statt aus bisher drei Mitgliedern. Das Gremium wurde erweitert, um mit Frau Dr. Jahn eine Expertin zum Thema Digitalisierung ins Unternehmen zu holen und somit den Trends und Entwicklungen in unserem industriellen Umfeld sowie bei unseren Kunden und den Endverbrauchern noch besser folgen zu können. Die Aktionäre des Unternehmens gaben ihre Zustimmung zu allen Beschlussvorlagen, die Vorstand und Aufsichtsrat auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung präsentierten.

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Franz Richter erläuterte in seinem Bericht die wesentlichen Entwicklungen und Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016 sowie des ersten Quartals 2017 und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr 2017. Insbesondere ging er in seiner Rede auf die aktuellen Trends und Entwicklungen in der Halbleiterindustrie sowie der Elektronikbranche ein und stellte umfassend dar, welchen wesentlichen Beitrag SÜSS MicroTec mit seinen Produkten und Lösungen hierbei leistet.

CORPORATE GOVERNANCE

Der Begriff Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Führung und Kontrolle von Unternehmen. Für SÜSS MicroTec gehören neben Transparenz eine offene Kommunikation mit Aktionären und Investoren sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand zu den wesentlichen Aspekten einer guten Corporate Governance. SÜSS MicroTec orientiert sich am Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK), der sich als Maßstab guter Unternehmensführung in Deutschland bewährt hat. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem nachfolgenden Bericht.

CORPORATE GOVERNANCE IM ÜBERBLICK

Mit der Zielsetzung, durch eine verantwortungsbewusste und langfristig ausgerichtete Unternehmensführung nicht nur den Fortbestand des Unternehmens, sondern auch eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes zu erreichen, hat die Corporate Governance einen hohen Stellenwert im Unternehmen. Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE haben sich im Geschäftsjahr 2017 erneut intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. SÜSS MicroTec strebt in seinem unternehmerischen Handeln danach, das Vertrauen, das uns Anleger, Finanzmärkte, Geschäftspartner, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit entgegenbringen, zu bestätigen und die Corporate Governance im Konzern fortlaufend weiterzuentwickeln. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf unserer Website unter www.suss.com > *Investor Relations* > *Corporate Governance*.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE haben am 9. Januar 2018 gem. § 161 Abs. 1 AktG folgende Entsprechenserklärung abgegeben:

Die SÜSS MicroTec SE wird den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 mit den nachfolgend aufgelisteten Ausnahmen entsprechen und hat den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Januar 2017 mit den nachfolgend aufgelisteten Ausnahmen entsprochen:

SELBSTBEHALT BEI D&O-VERSICHERUNGEN

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8 Abs. 3, bei Abschluss einer D&O-Versicherung (Vermögensschadenshaftpflichtversicherung) einen der gesetzlichen Regelung für Vorstände entsprechenden Selbstbehalt für den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec SE verfügt bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt für den Aufsichtsrat. Das verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbstbehalts nicht zusätzlich gefördert.

VERTIKALER VERGÜTUNGSVERGLEICH

In Ziffer 4.2.2 Abs. 2 Satz 3 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex dem Aufsichtsrat, bei der Festlegung der Vorstandsvergütung das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen Führungskreises sowie der Belegschaft insgesamt auch in der zeitlichen Entwicklung zu berücksichtigen, wobei der Aufsichtsrat festlegt, wie der obere Führungskreis und die relevante Belegschaft abzugrenzen sind.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE ist der Auffassung, dass die Festlegung des oberen Führungskreises und der relevanten Belegschaft unter Einbeziehung der zeitlichen Entwicklung in der Praxis zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen kann. Die SÜSS MicroTec SE erklärt daher insoweit vorsorglich eine Kodexabweichung. Der Aufsichtsrat hat bei Abschluss der derzeit gültigen Vorstandsverträge im Rahmen der Überprüfung der Angemessenheit nicht zwischen den Vergleichsgruppen im Sinne der Ziffer 4.2.2 Abs. 2 Satz 3 der Kodexfassung unterschieden und auch keine Erhebungen zur zeitlichen Entwicklung des Lohn- und Gehaltsgefüges durchgeführt. Er hält ein solches rein formales Vorgehen auch nicht für erforderlich, um die Angemessenheit der Vorstandsvergütung sicherzustellen.

VERSORGUNGSZUSAGEN

Unter Ziffer 4.2.3 Abs. 3 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex dem Aufsichtsrat, bei Versorgungszusagen das jeweils angestrebte Versorgungsniveau – auch nach der Dauer der Vorstandszugehörigkeit – und den daraus abgeleiteten jährlichen sowie langfristigen Aufwand für das Unternehmen zu berücksichtigen.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec weicht von dieser Empfehlung ab, da für die Vorstandsmitglieder kein bestimmtes „Versorgungsniveau“ im Ruhestand, sondern eine markt- und unternehmenskonforme Vergütung der aktiven Tätigkeit angestrebt wird. Unmittelbare Versorgungszusagen, bei denen die Gesellschaft selbst die zugesagten Leistungen erbringt, werden den Mitgliedern des Vorstands grundsätzlich nicht gewährt. Soweit die Gesellschaft den Vorständen einen Zuschuss zur Altersvorsorge gewährt und Beiträge in eine Direktversicherung (Kapitallebens- bzw. Rentenversicherung) einzahlt, ist damit keine Zusage eines bestimmten Versorgungsniveaus verbunden.

BILDUNG VON AUSSCHÜSSEN

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 5.3 in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Aufsichtsratsmitglieder die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen. Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec nur aus vier Aufsichtsratsmitgliedern besteht, ist die Bildung von Ausschüssen, die im Regelfall aus mindestens drei Mitgliedern bestehen müssen, nicht sinnvoll und im Übrigen auch nicht erforderlich, da im Plenum eine intensive und qualifizierte Diskussion stattfinden kann.

FESTLEGUNG EINER REGELGRENZE FÜR DIE ZUGEHÖRIGKEITSDAUER IM AUFSICHTSRAT

Entsprechend Punkt 5.4.1 Abs. 2 Satz 2 des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der Aufsichtsrat eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer im Aufsichtsrat festlegen. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE weicht von dieser Empfehlung ab, da die Festlegung einer Regelzugehörigkeitsgrenze den Handlungsspielraum sowie die Kompetenz des Aufsichtsrats gefährden könnte. Das unabhängige und verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec nicht durch die Begrenzung der Verweildauer im Aufsichtsrat gefördert. Im Gegenteil, durch die komplexe Produkt- und Unternehmensstruktur ist eine gewisse Verweildauer im Aufsichtsrat eher positiv zu sehen, da im Zeitverlauf wertvolle unternehmensspezifische Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt werden, die zum Wohl des Unternehmens eingesetzt werden können.

KOMMUNIKATION UND TRANSPARENZ

Die Unternehmenskommunikation bei SÜSS MicroTec verfolgt den Anspruch, alle Zielgruppen gleichberechtigt und zeitnah zu informieren und dabei größtmögliche Transparenz und Chancengleichheit für alle Kapitalmarktteilnehmer zu gewährleisten. Dazu nutzt das Unternehmen neben Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichten die Möglichkeit von Telefongesprächen, Konferenzen und Roadshows sowie die Website, um Aktionäre, institutionelle Investoren, Analysten und sonstige Interessierte über Entwicklungen im Konzern zu informieren. SÜSS MicroTec unterrichtet seine Aktionäre im Wesentlichen vier Mal im Jahr über die Geschäftsentwicklung sowie über die aktuelle Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Sie können unter > www.suss.com > *Investor Relations* neben allen Pflichtpublikationen, die dort in deutscher und englischer Sprache zum Download bereitgestellt sind, Präsentationen wesentlicher Veranstaltungen sowie Vorstandsinterviews im Video- oder Audioformat frei einsehen respektive abrufen.

Über die wiederkehrenden Termine wie den Termin der Hauptversammlung oder die Veröffentlichungszeitpunkte der Zwischenberichte unterrichten wir die Öffentlichkeit zeitnah und regelmäßig in einem Finanzkalender, der im Geschäftsbericht, in den Zwischenberichten sowie auf der Website unserer Gesellschaft veröffentlicht ist.

HAUPTVERSAMMLUNG

Auf der Hauptversammlung der SÜSS MicroTec SE können sich unsere Aktionäre mit Fragen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf direkt an Vorstand und Aufsichtsrat wenden. Wir bereiten die Hauptversammlung stets mit dem Ziel vor, den Aktionären alle für sie relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Hauptversammlung beschließt darüber hinaus unter anderem über die Gewinnverwendung, die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie über die Wahl des Abschlussprüfers.

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den anstehenden Tagesordnungspunkten sowie die Erläuterung der Teilnahmebedingungen werden in der Regel fünf bis sechs Wochen vor dem Hauptversammlungstermin bekannt gemacht. Alle Dokumente und Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung und können ebenfalls in Kopie bei der Investor Relations-Abteilung angefordert werden. Zudem sind wir bemüht, unseren Aktionären die Ausübung ihrer Rechte zu erleichtern. Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung entweder selbst ausüben oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen

weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Die Weisungen zur Stimmrechtsausübung können vor oder während der Hauptversammlung direkt vor Ort erteilt werden. Die Präsenz und die Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung veröffentlichen wir direkt im Anschluss an die Veranstaltung im Internet.

ZUSAMMENARBEIT VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Als Europäische Aktiengesellschaft (SE) unterliegt SÜSS MicroTec den europäischen SE-Regelungen, dem deutschen SE-Ausführungsgesetz und dem deutschen Aktienrecht. Die Gesellschaft verfügt über eine zweigeteilte Führungs- und Kontrollstruktur, die von den Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wahrgenommen wird. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zielgerichtet und effizient zusammen, um – unter Beachtung der Interessen unserer Mitarbeiter und unserer Aktionäre – eine nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens voranzutreiben. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Ihnen obliegt die Entwicklung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, sie stimmen diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgen für deren verantwortungsvolle Umsetzung.

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und bestellt die Vorstandsmitglieder. Wesentliche Vorstandsentscheidungen – etwa Akquisitionen, Desinvestitionen und Finanzmaßnahmen – sind an die Zustimmung des Aufsichtsrats gebunden.

Im Zuge der Umwandlung der SÜSS MicroTec AG in die Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) hat die Gesellschaft am 10. März 2017 entsprechend § 21 SEBG eine „Vereinbarung über das Verfahren der Information und Konsultation sowie der Mitbestimmung in der SÜSS MicroTec SE“ („Beteiligungsvereinbarung“) abgeschlossen. Diese Beteiligungsvereinbarung sieht vor, dass der Aufsichtsrat mit einem Arbeitnehmervertreter zu besetzen ist, sofern die SÜSS MicroTec SE und ihre Tochtergesellschaften (Gesellschaften im Sinne von § 2 Abs. 3 SEBG) mit Sitz in Deutschland in der Regel mehr als 2.500 Arbeitnehmer oder die SÜSS MicroTec Europa (SÜSS MicroTec SE und ihre Tochtergesellschaften mit Sitz in einem Land der Europäischen Union oder den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Land, das künftig aufgrund völkerrechtlicher Verträge in den Geltungsbereich des Rechts der SE einbezogen wird, zusammen) in der Regel mehr als 3.000 Arbeitnehmer beschäftigen. Ferner sieht die Vereinbarung vor, dass der Aufsichtsrat mit zwei Arbeitnehmervertretern zu besetzen ist, sofern die SÜSS MicroTec

SE und ihre Tochtergesellschaften (Gesellschaften im Sinne von § 2 Abs. 3 SEBG) mit Sitz in Deutschland in der Regel mehr als 3.000 Arbeitnehmer oder die SÜSS MicroTec Europa (SÜSS MicroTec SE und ihre Tochtergesellschaften mit Sitz in einem Land der Europäischen Union oder den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Land, das künftig aufgrund völkerrechtlicher Verträge in den Geltungsbereich des Rechts der SE einbezogen wird, zusammen) in der Regel mehr als 4.000 Arbeitnehmer beschäftigen und der Aufsichtsrat aus sechs oder mehr Mitgliedern besteht.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE setzt sich derzeit nur aus Anteilseignervertretern zusammen, da bislang die in der Beteiligungsvereinbarung festgelegten Grenzen nicht erreicht wurden.

Aufgrund seiner Größe hat der Aufsichtsrat bislang keine Ausschüsse gebildet, daher ist über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse nicht zu berichten.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im Interesse des Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern, stets sehr eng zusammen. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftspolitik sowie über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen werden dabei erläutert und begründet.

Wie es der Deutsche Corporate Governance Kodex vorsieht, gehört dem Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE mit Dr. Stefan Reineck nicht mehr als ein ehemaliges Vorstandsmitglied an. Berater- oder sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft bestanden unverändert im Berichtsjahr 2017 nicht. Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen sind, traten im Geschäftsjahr 2017 nicht auf.

ZIELE UND KRITERIEN DES AUFSICHTSRATS HINSICHTLICH SEINER ZUSAMMENSETZUNG

Ziel der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec SE ist es, die Unternehmensentwicklung zu nachhaltiger Ertragskraft und permanenter Anpassung an sich schnell wandelnde Anforderungen durch konstruktive Beratung und Überwachung des Vorstands auf der Basis relevanter Kompetenzen abzusichern. Durch eine ausreichende Kompetenzvielfalt der Mitglieder sollen ein breites Erfahrungsspektrum und unterschiedliche Sichtweisen zum Nutzen des Unternehmens eingebracht werden.

Die SÜSS MicroTec SE ist ein auf den Weltmarkt ausgerichtetes, technologieorientiertes Unternehmen, das sich in einem sehr dynamischen und technologisch anspruchsvollen Umfeld behaupten und entwickeln muss. Daher sind im Aufsichtsrat technologisches Beurteilungsvermögen und einschlägige Marktkenntnisse im internationalen Maßstab erforderlich. Darüber hinaus gewinnen dynamische Veränderungen in Markt, Technologie und Gesellschaft zunehmend an Bedeutung, die weitere Kompetenzen zu Digitalisierung und Human Resources erfordern. Für die technologische Expertise sind relevante Kenntnisse der Halbleiter- und halbleiternahen Industrie und deren Equipment-Industrie von besonderer Bedeutung. Um Trends und Entwicklungen in unseren sehr dynamischen Märkten vorausschauend und zuverlässig beurteilen zu können, sollten im Aufsichtsrat internationale Erfahrung und möglichst aktive Netzwerke vertreten sein.

Zusätzlich zu diesen genannten wichtigen Kompetenzen erwartet das Unternehmen von Aufsichtsratsmitgliedern und -kandidaten eine breite Erfahrung in anderen Bereichen, die möglichst ergänzend zu einer optimalen Besetzung des Aufsichtsrats beitragen. Dazu gehören insbesondere Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich strategischer Unternehmensentwicklung des Kapitalmarktes, der Rekrutierung von Führungskräften und moderner Vergütungsmodelle für alle Ebenen sowie eine erhöhte Sensibilität für ökonomisch-ökologische Grundsatzfragen. Folglich ist es das Ziel des Aufsichtsrats, neben dem Financial Expert erfahrene Persönlichkeiten zu gewinnen, die diese Bereiche abdecken. Aufsichtsratsmitglieder sollen neben den Fachkompetenzen über Methodenkompetenz zur Erarbeitung komplexer Sachverhalte und über Sozialkompetenz zur konstruktiven Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums und mit dem Vorstand verfügen.

Abhängig von der aktuellen Unternehmenssituation kann es sinnvoll sein, die Gewichte der einzelnen Kriterien neu zu bewerten und der Hauptversammlung entsprechende Veränderungen im Aufsichtsrat vorzuschlagen. Der Aufsichtsrat beobachtet dazu die Unternehmenssituation und bewertet die Aufsichtsratsbesetzung in regelmäßigen Abständen.

Die Festlegung einer über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Mindestzahl von unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern halten Vorstand und Aufsichtsrat angesichts der Größe des Aufsichtsrats nicht für sinnvoll, um das künftige Auswahlermessen bei der Besetzung von Aufsichtsratspositionen nicht zu stark einzuschränken.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE wird keine feste Regelzugehörigkeitsdauer für die Aufsichtsratsmitglieder festlegen, da eine solche Festlegung den Handlungsspielraum sowie die Kompetenz des Aufsichtsrats negativ beeinträchtigen könnte. Das

unabhängige und verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec nicht durch die Begrenzung der Verweildauer im Aufsichtsrat gefördert. Im Gegenteil, durch die komplexe Produkt- und Unternehmensstruktur ist eine gewisse Verweildauer im Aufsichtsrat eher positiv zu sehen, da im Zeitverlauf wertvolle unternehmensspezifische Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt werden, die zum Wohl des Unternehmens eingesetzt werden können.

SÜSS MicroTec prüft alle potenziellen Kandidaten für den Aufsichtsrat hinsichtlich ihrer Kompetenz und Verfügbarkeit, bevor ein Vorschlag an die Hauptversammlung gemacht wird. Zudem müssen potenzielle Kandidaten vorher eine Funktion als Vorstand, Geschäftsführer oder eine ähnlich verantwortungsvolle Position in einem vergleichbaren oder größeren Unternehmen ausüben oder ausgeübt haben. Alternativ können Experten kandidieren, die ein besonderes Wissen und Erfahrungen für unser Unternehmen mitbringen, sofern dies als bedeutsam für den Unternehmenserfolg anzusehen ist. Es gibt jedoch keine feste Bestimmung eines ganz bestimmten Zeitaufwands, den Aufsichtsratsmitglieder aufzubringen haben. Grundsätzlich nimmt das Unternehmen Abstand von potenziellen Kandidaten, die bereits fünf oder mehr Mandate in Aufsichtsgremien bekleiden, und orientiert sich damit auch an Empfehlungen von Stimmrechtsberatern.

Bei der Besetzung des Aufsichtsrats sollen zukünftig Frauen mit größerer Aufmerksamkeit berücksichtigt werden, um eine angemessene Frauenbeteiligung zu erreichen. Zudem sind börsennotierte und/oder mitbestimmungspflichtige Unternehmen seit 2015 gesetzlich verpflichtet, Zielgrößen für den Frauenanteil unter anderem im Aufsichtsrat festzulegen und zu veröffentlichen sowie über deren Stand der Umsetzung zu berichten (im nachfolgenden Abschnitt des Berichts). Aus Sicht der SÜSS MicroTec SE ist die Qualifikation der Aufsichtsratskandidaten maßgebliches Kriterium für die Übernahme eines Aufsichtsratsmandats und damit die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Bei den Vorschlägen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats unterstützt und berücksichtigt SÜSS MicroTec die im DCGK genannten Kriterien, sieht aber speziell in der Halbleiterbranche die Erfüllung einer bestimmten Quote für den Frauenanteil als problematisch an. Seit Mai 2017 gehört mit Frau Dr. Jahn eine Expertin in Sachen Digitalisierung im Maschinenbau und für die – mit Industrie 4.0 wachsende – Kundenbranche der Sensorhersteller dem Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE an.

Die Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder liegt bei 71 Jahren.

Interessenkonflikte werden bei der Besetzung des Aufsichtsrats vermieden, indem die Kandidaten bereits im Vorfeld einer Wahl Negativerklärungen abgeben. Sollte es während einer Wahlperiode zu potenziellen oder tatsächlichen Konflikten kommen, dann führen entsprechende Regelungen für Aufsichtsrat und Vorstand zu deren Offenlegung und zu einer angemessenen Behandlung im Plenum des Aufsichtsrats.

FESTLEGUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER TEILHABE VON FRAUEN AN FÜHRUNGSPPOSITIONEN

Durch das am 1. Mai 2015 in Kraft getretene „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ (§ 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 AktG) sind börsennotierte Gesellschaften wie die SÜSS MicroTec SE unter anderem verpflichtet worden, Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat, Vorstand und den nachfolgenden zwei Führungsebenen festzulegen. Darüber hinaus muss festgelegt werden, bis wann die jeweilige Zielgröße erreicht werden soll.

In Umsetzung der vorgenannten Verpflichtung beschloss der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ursprünglich am 7. September 2015 sowohl für den Frauenanteil im Aufsichtsrat als auch für den Frauenanteil im Vorstand der SÜSS MicroTec AG eine Zielgröße von jeweils null Prozent. Der Frauenanteil im Vorstand blieb bis zum 30. Juni 2017 mit null Prozent unverändert und entspricht damit der Zielfestlegung. Durch die Wahl von Frau Dr. Myriam Jahn zum Mitglied des Aufsichtsrats durch Beschlussfassung vom 31. Mai 2017 erhöhte sich dagegen der Frauenanteil im Aufsichtsrat auf 25 Prozent gegenüber einer Zielgröße von null Prozent.

Für die deutschen Gruppengesellschaften beschloss der Vorstand der SÜSS MicroTec AG am 2. September 2015, dass für die erste und zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands jeweils eine Zielgröße für den Frauenanteil von 20 Prozent angestrebt wird, und legte eine Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017 fest. Zum 30. Juni 2017 wurde die Zielfestlegung auf der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands übererfüllt, da der Frauenanteil zu diesem Zeitpunkt 27,3 Prozent betrug und sich damit gegenüber einem Frauenanteil zum Zeitpunkt der Beschlussfassung am 2. September 2015 von 18 Prozent deutlich erhöhte. Auch der Frauenanteil auf der zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands hat sich im Zeitraum vom 2. September 2015 bis zum 30. Juni 2017 von 14 Prozent auf 19,2 Prozent erhöht, wenngleich das gesetzte Ziel auf dieser zweiten Führungsebene von 20 Prozent nicht ganz erreicht werden konnte. Für die nur sehr geringe Abweichung von der Zielgröße auf der zweiten Führungsebene bestehen keine spezifischen Gründe.

Zum Ablauf der ersten Umsetzungsfrist beschloss der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG am 30. Juni 2017 für den Frauenanteil im Aufsichtsrat eine Zielgröße von 25 Prozent bei einer Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2022. Für den Frauenanteil im Vorstand von SÜSS MicroTec beschloss der Aufsichtsrat eine Zielgröße von null Prozent ebenso bei einer Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2022.

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG beschloss am 30. Juni 2017 für die erste Führungsebene unterhalb des Vorstands eine Zielgröße für den Frauenanteil von 30% bei einer Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2022, für die zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands eine Zielgröße für den Frauenanteil von 20% bei einer Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2022.

ORGANE

Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats sowie deren Mandate:

Dr. Franz Richter

- Dr.-Ing., Eichenau,
Vorstandsvorsitzender

Weitere Mandate:

- Siltronic AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats)
- Meyer Burger Technology AG, Gwatt, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)
- COMET Holding AG, Flamatt, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)

Michael Knopp (bis 30. April 2017)

- Diplom-Kaufmann, Ratingen,
Finanzvorstand

Weitere Mandate: keine

Robert Leurs (ab 1. Dezember 2017)

- Diplom-Kaufmann, Diplom-Finanzwirt, Stockdorf,
Finanzvorstand

Weitere Mandate: keine

Walter Braun

- Diplom-Ingenieur, Altensteig,
Produktionsvorstand

Weitere Mandate: keine

Dr. Stefan Reineck

- Kirchart, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC
Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchart;
Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec SE

Weitere Mandate:

- attocube systems AG, München
(stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA
(Mitglied im Board of Directors)
- Wittenstein SE, Igersheim (stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Jan Teichert

- Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG,
Landau, Isar; stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
der SÜSS MicroTec SE

Weitere Mandate: keine**Gerhard Pegam**

- Au/Bad Feilnbach, Geschäftsführender Gesellschafter der GPA
Consulting, Au/Bad Feilnbach; Aufsichtsratsmitglied der SÜSS
MicroTec SE

Weitere Mandate:

- OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz
(stellvertretender Verwaltungsratspräsident)
- Schaffner Holding AG, Solothurn, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)

Dr. Myriam Jahn (ab 31. Mai 2017)

- Düsseldorf, Mitglied des Vorstands der TiSC AG, Siegen;
Aufsichtsratsmitglied der SÜSS MicroTec SE

Weitere Mandate: keine**VERÄNDERUNGEN IN VORSTAND UND AUFSICHTSRAT**

Im Geschäftsjahr 2017 gab es zwei personelle Änderungen im Vorstand. Der Aufsichtsrat berief am 12. Oktober 2017 Herrn Robert Leurs mit Wirkung zum 1. Dezember 2017 für die Dauer von drei Jahren in den Vorstand der SÜSS MicroTec SE. In seiner Funktion als Finanzvorstand ist er verantwortlich für die Bereiche Finanz-, Rechnungswesen und Steuern, Recht & Versicherungen, IT, Facility Management und Investor Relations. In gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat beendete der damalige Finanzvorstand Herr Michael Knopp seine Organbestellung sowie seinen Dienstvertrag vorzeitig zum 30. April 2017.

Auch im Aufsichtsrat gab es im Geschäftsjahr 2017 eine Veränderung. Auf der Hauptversammlung 2017 wählten die Aktionäre die bestehenden drei Aufsichtsräte Herrn Dr. Stefan Reineck, Herrn Jan Teichert sowie Herrn Gerhard Pegam erneut für eine Periode von fünf Jahren (bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt) in den Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE, zudem wurde das Gremium um Frau Dr. Myriam Jahn erweitert und damit gehören dem Aufsichtsrat nunmehr vier Mitglieder an.

BESITZ VON AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN

Die im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec SE besitzen zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2017 folgende Anzahl an Aktien und Bezugsrechten:

BESITZ VON AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN

	Anzahl der Aktien zum 31.12.2017	Veränderung gegenüber 31.12.2016	Anzahl der Aktienoptionen zum 31.12.2017	Veränderung gegenüber 31.12.2016
Aufsichtsrat				
Dr. Stefan Reineck	9.600	–	0	–
Jan Teichert	0	–	0	–
Dr. Myriam Jahn	0	–	0	–
Gerhard Pegam	0	–	0	–
Vorstand				
Dr. Franz Richter	65.000	5.000	0	–
Robert Leurs	0	0	0	–
Walter Braun	10.120	-8.180	0	–

MELDEPFLICHTIGE AKTIENGESCHÄFTE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach Artikel 19 Marktmissbrauchsverordnung (MAR) gesetzlich verpflichtet, eigene Geschäfte mit Aktien der SÜSS MicroTec SE oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten offenzulegen, soweit der Wert der von dem Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte die Summe von 5.000 Euro erreicht oder übersteigt.

Sämtliche Geschäfte des Vorstands und des Aufsichtsrats werden auf der Website des Unternehmens unter > www.suss.com > *Investor Relations* > *Die Aktie* > *Eigengeschäfte von Führungskräften* veröffentlicht.

RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG

SÜSS MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie die Zwischenberichte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union für börsennotierte Gesellschaften anzuwenden sind. Der Einzelabschluss von SÜSS MicroTec SE wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Am 31. Mai 2017 bestellte die Hauptversammlung die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer von SÜSS MicroTec für das Geschäftsjahr 2017. Damit werden Jahresabschluss und Konzernabschluss von SÜSS MicroTec zum fünften Mal in Folge von einem Unternehmen der BDO-Gruppe geprüft. Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat 2017 neben der Prüfungstätigkeit keinerlei Beratungsleistungen für SÜSS MicroTec erbracht. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Des Weiteren wurde mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass dieser den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse informiert, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben. Leitender Prüfer für das Geschäftsjahr 2017 war Wirtschaftsprüfer Thomas Steiner, der die Abschlussprüfung und Konzernabschlussprüfung von SÜSS MicroTec zum vierten Mal als leitender Prüfer betreute.

ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die Konzernerklärung zur Unternehmensführung nach § 289f und § 315d HGB ist Bestandteil des Lageberichts und wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter > www.suss.com > *Investor Relations* > *Corporate Governance* > *Erklärung zur Unternehmensführung* allgemein zugänglich gemacht und ist zudem im zusammengefassten Lagebericht vollständig abgedruckt.

VERGÜTUNGSBERICHT

Die Grundzüge des Vergütungssystems haben wir im Vergütungsbericht dargestellt, der im zusammengefassten Lagebericht abgedruckt ist.

NICHTFINANZIELLE KONZERNERKLÄRUNG GEMÄSS § 315B HGB

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Thema Nachhaltigkeit genießt bei SÜSS MicroTec Priorität und wir bekennen uns klar zu unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft. Nachhaltigkeit bedeutet für uns ein enges Zusammenspiel aus Ökonomie, Ökologie und ethischem Verhalten. Ob mit Kunden, Mitarbeitern, Wettbewerbern oder anderen Geschäftspartnern, SÜSS MicroTec strebt nach einem fairen und sozial verträglichen Umgang miteinander. Darüber hinaus legt das Unternehmen die gleichen hohen Maßstäbe an seine Zulieferer und Geschäftspartner an. Unser Geschäft ist geprägt von Internationalität und einer kulturellen Vielfalt. Überall dort, wo wir geschäftlich tätig sind, verstehen wir uns als Mitglied der jeweiligen Gesellschaft und tragen aktiv dazu bei, die Gemeinschaft und den Lebensraum positiv zu gestalten.

Als Vorstand verstehen wir unsere Führungsrolle dahingehend, dass wir dieses Unternehmen nicht nur nach wirtschaftlichen und finanziellen Kennzahlen führen, sondern auch unserer Verantwortung der Gesellschaft und der Umwelt gegenüber gerecht werden.

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Erfolgsfaktor für unternehmerisches Handeln, sondern auch ein Zeichen zunehmender Wertewandlung in unserer Gesellschaft. Endverbraucher und Kunden hinterfragen mit Recht die Fertigungspraktiken, Arbeitsbedingungen oder den Materialeinsatz in den Produkten und Dienstleistungen, die sie konsumieren. Wie viele Emissionen stößt das Fahrzeug aus, wie hoch ist der Energieverbrauch eines elektronischen Gerätes oder welche Rohstoffe und Materialien wurden bei der Herstellung verarbeitet? – diese Gedanken beeinflussen die Kaufentscheidungen moderner Kunden und werden somit zu einem zunehmend wichtigen Wirtschaftsfaktor.

Die folgenden Ausführungen und Beschreibungen der einzelnen Aspekte erfolgen gemäß § 315c und § 289c HGB und sind angelehnt an die UN Global Compact Principles.

Der Vorstand der SÜSS MicroTec SE



Dr. Franz Richter
Vorstands-
vorsitzender



Robert Leurs
Finanzvorstand



Walter Braun
Produktions-
vorstand

GESCHÄFTSMODELL

Der SÜSS MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe ein leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor-, den Forschungs- und den Produktionsbereich. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeits-schwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigen Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen wie die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung. Der Konzern produzierte im Geschäftsjahr 2017 an vier Standorten, davon mit Garching bei München (Hauptsitz) und Sternenfels zwei in Deutschland und mit Hauterive einen Standort in der Schweiz sowie mit Corona, Kalifornien, einen in den USA.

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec SE als Management- und Finanzierungsholding, und den mehrheitlich im Eigentum der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebs- und Servicetätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt neben den vier Produktionsstandorten über weitere Standorte mit Schwerpunkt Service und Vertrieb in Großbritannien, Frankreich, Japan, China, Singapur, Korea und Taiwan.

NACHHALTIGKEIT BEI SÜSS MICROTEC

Um die relevanten Nachhaltigkeitsthemen unseres Unternehmens zu identifizieren, haben wir eine mehrstufige Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt. Aus den für SÜSS MicroTec wesentlichen Bereichen wurden Konzepte und Ziele abgeleitet, die unsere Nachhaltigkeitsstrategie definieren.

Ziele

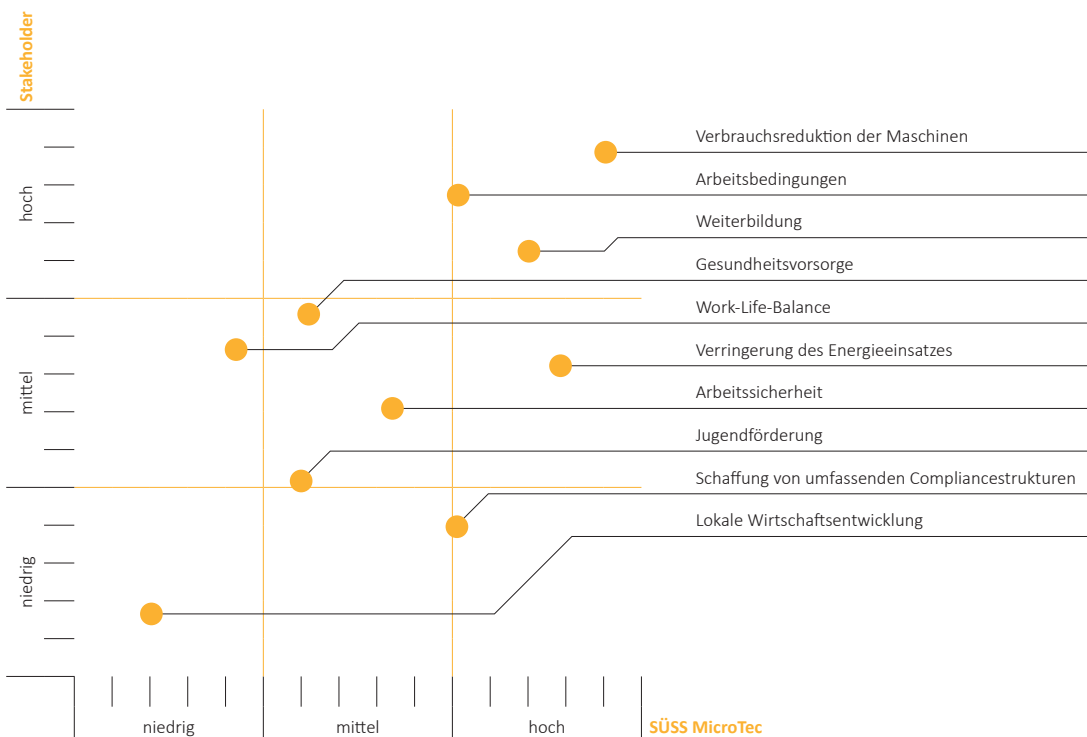
Das übergeordnete Ziel unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist die Absicherung der langfristigen Zukunftsfähigkeit unseres Kerngeschäfts, zudem der Ausbau neuer und innovativer Technologien. Viele aktuelle Entwicklungen bieten ein erhebliches Wachstumspotenzial für SÜSS MicroTec. Unsere Aufgabe ist es, dieses Potenzial unter Einhaltung unserer eigenen und der gesetzlich vorgegebenen Verhaltensregeln und Vorgaben auszuschöpfen. Aktuelle Trends in den Bereichen Digitalisierung, Vernetzung, Kommunikation und Mobilität bieten im Hinblick auf Umsatzwachstum und den Ausbau von Marktanteilen großes Potenzial für das Unternehmen. Gleichmaßen bedeutsam ist es, diese Potenziale unter Einhaltung unserer Umweltstandards und Umweltziele sowie unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft zu heben. Darüber hinaus profitieren wir nicht nur von den aktuellen Trends, sondern unsere Produkte unterstützen diese nachhaltig. Immer mehr Sensoren kommen in der Industrie, der Automobilbranche, aber auch im Haushalt zum Einsatz. Darüber hinaus werden in unseren Entwicklungsprozessen zunehmend neben der eigentlichen Funktion der Maschine auch Themen wie die Verbesserung der

Energieeffizienz oder die Verbrauchsverringering von Medien berücksichtigt. Unsere Kunden fordern nicht nur technisch einwandfreie Geräte, sondern auch die Einhaltung bestimmter Umweltaspekte und Arbeitsbedingungen. SÜSS MicroTec lehnt jede Form der Kinderarbeit, der Zwangsarbeit oder vergleichbare Praktiken bei sich und bei seinen Lieferanten und Kunden strikt ab.

Risikomanagement

Die aktuellen Trends in unserer Industrie bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten für unser Unternehmen. Diese zu erkennen und zu nutzen ist eine wichtige Managementaufgabe. Gleichzeitig ist ein effektives Risikomanagement unverzichtbar. Das Chancen- und Risikomanagement von SÜSS MicroTec zielt darauf ab, den Unternehmenswert nachhaltig zu sichern und zu steigern. Dazu gehören das frühzeitige Erkennen von Chancen sowie die Identifikation und angemessene Bewertung der damit verbundenen Risiken und die adäquate Reaktion darauf.

WESENTLICHKEITSANALYSE FÜR DEN SÜSS MICROTREC-KONZERN



Ein wesentlicher Teil des Risikomanagementsystems ist ein softwarebasiertes Reportingsystem, das die folgenden Bereiche abdeckt: Materialwirtschaft, Produktion/Fertigung, Markt/Vertrieb/Service, Forschung & Entwicklung/Produktentwicklung, Personal/Organisation, Finanzen, IT, Recht und allgemeine Sicherheit. In diesem System müssen die von der Unternehmensführung bestimmten Risikoverantwortlichen mindestens einmal im Quartal oder bei konkreten Anlässen ad hoc die identifizierten Risiken melden und quantitativ bewerten. Eine Bewertung erfolgt anhand der beiden Kriterien möglicher Schaden (ausgedrückt in Euro) und Eintrittswahrscheinlichkeit. Besonders bei signifikanten Risiken sind die Verantwortlichen angehalten, geeignete Gegenmaßnahmen oder Handlungsempfehlungen zu geben. Regelmäßig wird auch der Aufsichtsrat über das Risikomanagementsystem und die materiellen Risiken informiert. Zudem finden unternehmensinterne Schulungen für die Risikoverantwortlichen statt. Die Wirksamkeit der Maßnahmen und die Entwicklung der Risiken werden fortlaufend verfolgt.

Im Chancen- und Risikobericht dieses Geschäftsberichts finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Geschäftsrisiken sowie eine detaillierte Beschreibung des Risikomanagementsystems.

UMWELTSCHUTZ

SÜSS MicroTec bekennt sich klar zu seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt. Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit sind eigenständige Werte und integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Unsere Verantwortung erstreckt sich vom Komponenteneinkauf bis hin zur Wiederverwertung unserer gebrauchten Maschinen.

ISO-14001-Zertifizierung

Als Rahmenwerk für unser Umweltmanagementsystem dient die ISO 14001. Bei SÜSS MicroTec beschäftigen wir uns im Rahmen des Umweltmanagements bereits seit 2014 intensiv mit der Systematisierung des Umweltmanagements und der Einführung von ISO14001:2015. In den Geschäftsjahren 2015 und 2016 wurden Systemanalysen, interne Audits und eine Vorprüfung (Stage-I-Audit) mit dem Auditierer (DQS) durchgeführt. Im Geschäftsjahr 2016 fand dann die erfolgreiche Auditierung des Umweltmanagementsystems statt. SÜSS MicroTec gehört damit zu den ersten Unternehmen, die die Herausforderung der neuen ISO-Norm angenommen haben.

Mehrwert durch Mikroelektronik

In der Halbleiterindustrie spielen neben einer energieeffizienten Produktion auch die technischen Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz der Endprodukte seit vielen Jahren eine wichtige Rolle. Beispielsweise konnten der Kraftstoffverbrauch und der Abgasausstoß moderner Fahrzeuge in den vergangenen Jahren durch den zunehmenden Einsatz von Sensoren und elektronischen Steuerungen deutlich reduziert werden. Auch bei Haushaltsgeräten, Industrieanlagen, Beleuchtungskonzepten, Computern und Handys sorgen mikroelektronische Bauelemente für den intelligenten Einsatz und schonenden Umgang mit wertvollen Ressourcen wie Strom, Wasser, Gas oder Kraftstoff. Dieser Trend entwickelte sich im Lauf der Zeit zu einem zusätzlichen Wachstumstreiber für unser Geschäft. Insbesondere Themen wie energiesparende Beleuchtungskonzepte, Sensorik und intelligente Ressourcennutzung durch gezielte Datenanalyse, Vernetzung und mobile Kommunikation spielen eine immer bedeutendere Rolle in unserem alltäglichen Leben. SÜSS MicroTec hilft mit seinen Produkten und Lösungen, elektrische und elektronische Geräte energieeffizienter und leistungsstärker zu machen. Gleichzeitig sind wir bemüht, den Herstellungsprozess unserer Maschinen so ressourcen- und umweltschonend wie möglich zu gestalten. Darüber hinaus kommen viele Bauelemente, die unter anderem auf unseren Maschinen gefertigt werden, in der Industrie für erneuerbare Energien wie Wind und Solarenergie zum Einsatz.

Gemäß unserer Wesentlichkeitsanalyse sind die beiden wichtigsten Umweltaspekte zum einen die Verbrauchsreduktion von eingesetzten Rohstoffen und Materialien im Produktionsumfeld und zum anderen die Verringerung des Energieeinsatzes in unserer Fertigung. Auf diese Aspekte, unsere damit einhergehenden Umweltkonzepte und deren Ziele und mögliche Risiken gehen wir auf den folgenden Seiten ein.

Verbesserung der Energieeffizienz auf allen Ebenen

Unser wesentliches Umweltziel ist die Verbesserung der Energieeffizienz in unserer Fertigung und unserer Maschinen. Zudem tragen auf unseren Maschinen gefertigte Bauelemente dazu bei, die Energieeffizienz elektronischer Endgeräte zu steigern, und wir unterstützen darüber hinaus den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. In unserem Fall ist dies im Wesentlichen der Verbrauch von Energieträgern und Verbrauchsstoffen. Das Thema Umweltmanagement ist ein eigenes Vorstandsressort, das in den Wirkungsbereich des Produktionsvorstands fällt.

Verbrauchsreduktion unserer Maschinen im Produktionsumfeld

Die Verbesserung der ökologischen Eigenschaften und der Umweltverträglichkeit unserer Produkte ist ein wichtiger Teil unserer Entwicklungsarbeit. So legen wir verstärkt Wert auf einen möglichst geringen Einsatz von Energieträgern, von Chemikalien und sonstigen Prozessmaterialien im Fertigungsprozess und während des Betriebs unserer Maschinen. Bei Belackungs- und Entwicklungsgeräten, Bondern und Fotomaschinen-Equipment zielen ein innovatives Prozessmanagement und ein zielgerichtetes Maschinendesign darauf, diese Verbräuche deutlich zu reduzieren.

Ein bereits abgeschlossenes Projekt ist beispielsweise die Entwicklung des LED-Lampenhauses für unsere Mask-Aligner. Im Geschäftsjahr 2016 wurde das neuartige UV-LED-Lampenhaus für den Einsatz in Belichtungsgeräten (Mask-Alignern <1000 Watt) in den Markt eingeführt. Mit der Entwicklung und Umsetzung des umweltfreundlichen UV-LED-Lampenhauskonzepts für Mask-Aligner ist uns ein weiterer wichtiger Schritt im Hinblick auf Ressourcenschonung und Umweltschutz gelungen. Die Lebensdauer der innovativen UV-LED-Lichtquelle ist um ein Vielfaches höher als bei der bisher verwendeten Quecksilberdampfampe und die Systeme sind damit auch quecksilberfrei. Zusätzlich entfallen im Produktionsprozess die zeit- und energieintensiven Aufwärm- und Abkühlphasen – die LED muss nur dann eingeschaltet werden, wenn eine Belichtung tatsächlich durchgeführt wird. Beide Faktoren tragen wesentlich zum geringeren Energieverbrauch bei, die Verbrauchsreduktion bewegt sich hier bei circa 60 Prozent. Zudem stellt die LED-Technologie hinsichtlich des Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutzes eine deutlich verbesserte Lösung dar.

Neben Energie spielt der sorgfältige Umgang mit Chemikalien eine große Rolle. Die fortlaufende Verbesserung unserer Maschinen im Hinblick auf den Verbrauch von Nasschemikalien ist ein wichtiges Ziel unserer Entwicklungsarbeit.

Verringerung des Energieeinsatzes in der Fertigung und Verwaltung

Es geht uns nicht nur um die Steigerung der Energieeffizienz unserer Produkte beziehungsweise der gefertigten Endprodukte, sondern jeder SÜSS MicroTec-Mitarbeiter trägt gemäß unseren Vorgaben und Richtlinien im täglichen Arbeitsleben die Verantwortung, unsere natürlichen Ressourcen zu schützen und sorgsam mit ihnen umzugehen, etwa beim Verbrauch von Strom oder anderen Verbrauchsstoffen. Wie die Produktion ist auch das Gebäudemanagement angehalten, materialschonend zu arbeiten und Reststoffe sowie den Energieverbrauch zu reduzieren. Hierbei

werden der maßvolle Einsatz von Materialien und das Recycling oder die Wiederverwendung entsprechend gefördert. In den Bereichen Forschung, Entwicklung und Konstruktion kommen unsere Richtlinien zu Ressourcenschonung, Energieeinsparung, Ausrüstung und Materialien unserer Produkte zur Anwendung.

Unser Ziel ist es, den Energieeinsatz (Strom, Gas, Heizöl) an allen Produktionsstandorten zu optimieren. Im Zeitraum von 2012 bis 2020 wollen wir den Energieeinsatz an den Standorten Garching und Sternenfels um 16–18 Prozent reduzieren. Diese Zahlen sind jedoch nicht statisch, sondern in Relation zu Änderungen im Umsatz (Umwelteffizienz der Wirtschaftsleistung) und der Anzahl der Mitarbeiter (Umwelteffizienz der Beschäftigung) angelegt. Für die beiden deutlich kleineren Fertigungsstandorte Hauterive, Schweiz, und Corona, USA, haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Umweltziele definiert.

Die Zielerreichung wird jährlich im Rahmen einer CO₂-Bilanz überprüft. Im Geschäftsjahr 2016 lagen die Werte trotz einer Steigerung im Umsatz und bei den Mitarbeitern in absoluten Zahlen bei circa –7 Prozent und damit im Rahmen der Vorgaben. Bereinigt man, neben der Betrachtung der absoluten Verbrauchszahlen, den Einfluss des steigenden Umsatzes und steigender Mitarbeiterzahlen, so haben wir ein Teilziel bereits erreicht. Bei einer Betrachtung pro Mitarbeiter ergibt sich eine Verringerung des Energieeinsatzes um mehr als 20 Prozent. Die Umwelteffizienz der Wirtschaftsleistung, im Rahmen einer Betrachtung pro Umsatz, hat sich um über 13 Prozent verbessert. Die CO₂-Bilanz für das Geschäftsjahr 2017 wird erst nach Veröffentlichung des Geschäftsberichts im Mai 2018 verfügbar sein.

Um diese Umweltziele zu erreichen, hat SÜSS MicroTec in den vergangenen Jahren beispielsweise am Produktionsstandort Garching verschiedene energieeffiziente Maßnahmen wie die Optimierung der Pumpensysteme in der Heizungs- und Klimatechnik, den Einsatz von Druckluftkompressoren mit Wärmerückgewinnung, verbesserte Beleuchtungskonzepte sowie generell einen bewussteren Umgang mit Energie eingeführt. Aufgrund altersbedingter Funktionsdefizite wurden im Geschäftsjahr 2013 die Kälteaggregate am Standort Garching in mehreren Bauabschnitten in den Reinräumen erneuert. Die zwei neuen Kälteaggregate, die mit einer „freien Kühlung“ ausgestattet sind, können Energieeinsparungen bei Außentemperaturen unter 11°C bewirken. Erfahrungsgemäß geht man davon aus, dass sich bei diesen Temperaturen (an circa 90 Tagen/Jahr) der Kühlbedarf um circa 30 Prozent reduziert, das heißt, die Kompressoren der Kältemaschinen werden dadurch entlastet und die Energiekosten gesenkt.

Ein weiterer Baustein unserer Umweltstrategie sind der Rückkauf und die sachgerechte Aufarbeitung von gebrauchten Maschinen. Mit großer Sorgfalt konstruieren unsere Mitarbeiter unsere Maschinen, die häufig für eine lange Nutzungszeit ausgelegt sind. Eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren oder länger ist keine Seltenheit und liefert einen Beweis für die herausragende Wirtschaftlichkeit und Qualität. Mit unserem Tochterunternehmen SÜSS MicroTec ReMan bieten wir unseren Kunden zudem die Möglichkeit, gebrauchte, von uns sorgfältig generalüberholte Maschinen zu einem günstigeren Preis zu erwerben. Damit entlasten wir das Beschaffungsbudget unserer Kunden, verlängern die Lebensdauer gebrauchter Maschinen und sparen wertvolle Ressourcen.

Wesentliche Risiken im Umweltbereich

Neben den vielfältigen Chancen hat die Wesentlichkeitsanalyse, zusammen mit den Informationen aus unserem Risikomanagementsystem, gewisse Risiken im Umweltbereich aufgezeigt. Nach unserer Einschätzung ist jedoch keines davon als wesentlich im Sinne von unternehmensgefährdend einzustufen. Wir möchten an dieser Stelle dennoch über die wichtigsten Risiken berichten und die Gegenmaßnahmen aufzeigen, die wir ergriffen haben.

Ein Verfehlen unserer Umweltziele im Hinblick auf die Verringerung des Energieeinsatzes birgt grundsätzlich die Gefahr steigender Energiekosten für das Unternehmen. Im Falle von rapide ansteigenden Kosten für Strom, Gas, Wasser oder Heizöl wird sich dies negativ auf die Rentabilität des Unternehmens auswirken.

Die Zufriedenheit der Kunden ist ein zentraler Baustein unseres Unternehmenserfolgs und natürlich der Unternehmensstrategie. Ein nennenswertes Risiko für unseren Geschäftsverlauf bestünde dann, wenn es uns nicht gelingen würde, nachhaltig die Kundenwünsche etwa im Hinblick auf Energieeffizienz und Medienverbräuche zu erfüllen. Um dem entgegenzuwirken, wird bereits im Entwicklungsprozess der Maschinen großes Augenmerk auf den Energie- und Medienverbrauch sowie die generellen Umwelteigenschaften gelegt. Darüber hinaus werden unsere innovativen Produkte und Lösungen oft in enger Zusammenarbeit mit den Kunden oder mit Halbleiterinstituten entwickelt beziehungsweise weiterentwickelt.

Ein weiteres Risiko bilden Unfälle, verbunden mit Risiken für die Gesundheit der Mitarbeiter sowie für die Umwelt. Kosten für die Instandsetzung der Maschine sowie ein Reputationsverlust könnten mögliche Folgen sein. Durch hohe Qualitätsstandards bereits bei der Konzeption der Geräte und durch sorgfältige und verantwortungsbewusste Fertigung und Installation der Maschinen sowie durch gezielte Schulungen der Operators, wird das Risiko eines Unfalls auf einem möglichst geringen Niveau gehalten.

ARBEITNEHMERBELANGE

Unsere unternehmerischen Entscheidungen haben einen vielfältigen Einfluss auf die Umwelt, auf einzelne Personen, insbesondere Mitarbeiter, aber auch auf Zulieferer, Kunden und andere Geschäftspartner. Den größten direkten Einfluss hat das Unternehmen jedoch auf seine Mitarbeiter, deshalb stehen die SÜSS MicroTec-Mitarbeiter im Fokus unserer Bemühungen zum Thema Nachhaltigkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Durch das "Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst" sind börsennotierte Gesellschaften verpflichtet worden, Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat, Vorstand und den nachfolgenden zwei Führungsebenen festzulegen. In der Konzernklärung zur Unternehmensführung - veröffentlicht im Lagebericht sowie auf der Webseite des Unternehmens - nimmt das Unternehmen ausführlich Stellung zum Thema Diversitätskonzept und zu den im Unternehmen festgelegten Quoten in der einzelnen Führungsebenen. Tochterunternehmen der SÜSS MicroTec SE, die in Deutschland ansässig sind, unterliegen dem Betriebsverfassungsgesetz, welches die Mitbestimmung in Unternehmen regelt. Es gibt in allen deutschen Tochterunternehmen Betriebsräte, die von den Mitarbeitern gewählt wurden und die die Interessen der Arbeitnehmer vertreten. Zudem hat die SÜSS MicroTec SE, als Europäische Aktiengesellschaft, seit 2017 einen Betriebsrat, der die Arbeitnehmerinteressen vertritt.

Ziele

Die Zufriedenheit, Gesundheit und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen uns sehr am Herzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Unser Geschäft ist geprägt von Internationalität, globaler Ausrichtung und kultureller Vielfalt. Über den Globus verteilt haben wir Mitarbeiter in Entwicklung, Produktion, Verwaltung, Vertrieb und Service, welche ein wichtiges Netzwerk für den standortübergreifenden Wissensaustausch und die interkulturelle Zusammenarbeit bilden. Wir arbeiten mit möglichst kurzen Entscheidungswegen und ermöglichen unseren Mitarbeitern, sich einzubringen und sich entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen weiterzuentwickeln, denn die Motivation, das Wissen und die Flexibilität unserer Mitarbeiter sind eine wichtige Voraussetzung für den langfristigen Unternehmenserfolg.

Ein Nachhaltigkeitsziel im Hinblick auf Arbeitnehmerbelange ist die Vermeidung von Arbeitsunfällen in der Fertigung. Darüber hinaus liegt uns das Thema Weiterbildung besonders am Herzen. Wir wollen die Qualität und die Quantität der angebotenen und der wahrgenommenen Weiterbildungsmaßnahmen für unsere

Mitarbeiter, aber auch für Kunden, in Zukunft spürbar steigern. Im Geschäftsjahr 2016 hat das Unternehmen in Deutschland knapp 240 Euro pro Mitarbeiter für externe Weiterbildungen ausgegeben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 waren es in Deutschland etwa 480 Euro pro Mitarbeiter. Wir wollen diesen Wert im laufenden Geschäftsjahr mit zielgerichteten Maßnahmen sinnvoll steigern.

Im Geschäftsjahr 2017 gab es sieben gemeldete Arbeitsunfälle an den beiden Produktionsstandorten in Deutschland. Im Vorjahr lag die Zahl der gemeldeten Arbeitsunfälle bei sechs. Unser Ziel ist es, Arbeitsunfälle möglichst vollständig zu vermeiden. Die Festlegung einer genauen und realistischen Zielgröße erscheint aus unserer Sicht nicht sinnvoll. Beim Thema Arbeitssicherheit sind die ausländischen Vertriebs- und Servicestandorte weniger relevant, da keine Fertigung stattfindet. In unserem Werk in Corona, Kalifornien, gab es im Geschäftsjahr 2017 einen gemeldeten Arbeitsunfall, nachdem es im Geschäftsjahr 2016 zwei Vorfälle gab. Dort – wie an allen anderen Produktionsstandorten – finden regelmäßig Schulungen und Sicherheitsunterweisungen für „gefährdete“ Mitarbeiter, zum Beispiel in der Produktion oder im Lager, statt.

Angemessenes Arbeitsumfeld

Wie in unserer Erklärung zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit dargelegt, gibt es spezielle Programme, um die höchsten Standards im Hinblick auf Sicherheit am Arbeitsplatz zu erfüllen. Wir führen an unseren Produktionsstandorten detaillierte Statistiken über Arbeitsunfälle und werten diese aus. In regelmäßigen Abständen bieten wir darüber hinaus betriebsärztliche Termine etwa zu kostenlosen Sehtests oder Schutzimpfungen an. 2016 haben wir erstmals einen so genannten Gesundheitstag am Standort Garching durchgeführt. Hier konnten sich die Kollegen kostenlos beraten und untersuchen lassen. Diese Maßnahmen sollen helfen, die Anzahl der Arbeitsunfälle und Krankmeldungen in den kommenden Jahren weiter zu reduzieren.

Weiterbildung

Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wesentliches Element für ein erfolgreiches Unternehmen. Deshalb ist die gezielte Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter ein wesentliches Ziel unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Egal ob Ingenieure, Softwareentwickler oder zum Beispiel Mitarbeiter im Personalwesen, die sich ständig ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie die von Innovationen getriebene Halbleiterbranche machen es unverzichtbar, dass die Kolleginnen und Kollegen sich stetig weiterbilden und sich somit im Sinne der Firma weiterentwickeln.

Durch gezielte Maßnahmen soll das Thema Weiterbildung größere Bedeutung bekommen und durch die Verstärkung der internen Weiterbildungsmöglichkeiten sollen neue Wege zur Mitarbeiter-schulung gefunden werden. Im Geschäftsjahr 2017 wurde zu diesem Zweck das SÜSS Excellence-Programm geschaffen. Das Programm mit seinen Themenschwerpunkten aus den Bereichen HR, Prozessoptimierung und Kommunikation bietet dem Mitarbeiter an, seine Aus- und Weiterbildung bei SÜSS MicroTec auf solide Füße zu stellen und seine individuelle Situation am Arbeitsplatz zu verbessern. Das Ganze ist eingebettet in Bemühungen um die konstruktive Gestaltung der Unternehmenskultur.

Wesentliche Risiken bei Arbeitnehmerbelangen

Im aktuellen konjunkturellen Umfeld und bei der industrieübergreifenden hohen Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern wird die Aufgabe, fähige Mitarbeiter zu finden, auszubilden und langfristig an das Unternehmen zu binden, immer wichtiger. Flexible Arbeitszeitmodelle, eine vernünftige Work-Life-Balance sowie eine angemessene und attraktive Entlohnung sind heute Grundvoraussetzungen für die Besetzung von vielen offenen Stellen. Sollte es uns im internationalen oder auch im lokalen Wettbewerb mit großen Konzernen und anderen Unternehmen nicht gelingen, ausreichend Nachwuchs bzw. neue Mitarbeiter für die anstehenden Herausforderungen zu finden, so kann dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Zukunft des Unternehmens haben. Nicht häufig, aber dennoch regelmäßig verlassen Wissensträger das Unternehmen oder gehen in den verdienten Ruhestand. In diesen Fällen muss es uns gelingen, zum Zeitpunkt des Ausscheidens bereits geeignete Nachwuchskräfte an Bord zu haben, damit ein fließender Übergang und möglichst geringer Know-how-Verlust gewährleistet sind.

ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE

SÜSS MicroTec respektiert die international anerkannten Menschenrechte und unterstützt deren Einhaltung. Wir respektieren die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Darüber hinaus fördern wir die Chancengleichheit und unterbinden Diskriminierung bei der Einstellung von Arbeitnehmern sowie bei deren Beförderung. Wir arbeiten mit Individuen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, Kultur, Religion, verschiedenen Alters, unabhängig von Behinderung, Hautfarbe, sexueller Identität, Weltanschauung und Geschlecht zusammen. Gemäß unseren eigenen Vorgaben und den Arbeitsgesetzen der Länder, in denen wir aktiv sind, dulden wir grundsätzlich keinerlei Diskriminierung auf Basis dieser Eigenschaften, keine Belästigung (verbal, in sozialen Netzwerken, körperlich oder sexuell), Mobbing oder sonstige persönliche Angriffe auf einzelne Personen. SÜSS MicroTec

lehnt zudem jede Form der Kinderarbeit, der Zwangsarbeit oder vergleichbare Praktiken bei sich und bei seinen Lieferanten und Kunden strikt ab.

Besondere Bedeutung besitzen für uns Werte wie Ehrlichkeit, Loyalität und Integrität sowie die persönliche Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters. Es wurde ein Verhaltenskodex als Teil des gruppenweiten Compliance-Programms verabschiedet, um die rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integrität der SÜSS MicroTec-Gruppe weiter zu stärken. Dieser Verhaltenskodex beinhaltet demnach Mindeststandards, die für jeden Mitarbeiter der SÜSS MicroTec SE und ihrer Tochtergesellschaften weltweit verbindlich sind. Die gleichen hohen Standards fordern wir auch von unseren Lieferanten.

Lieferkette

Als international tätiges und fortlaufend expandierendes Unternehmen mit einer hohen Produktvielfalt haben wir eine immer komplexer werdende Wertschöpfungskette. Wir nehmen dabei die Rolle des Herstellers von Maschinen ein, die an produzierende Unternehmen weiterverkauft werden und beim Endkunden nur bedingt sichtbar werden. Grundsätzlich beziehen wir eine Vielzahl unserer Komponenten und Baugruppen von Zulieferunternehmen in Deutschland und Europa. Einige Spezialbauteile wie beispielsweise Roboter oder Ähnliches werden von internationalen Herstellern bezogen.

Um unsere Lieferkette in Hinblick auf Aspekte der Nachhaltigkeit zu optimieren, haben wir verschiedene Maßnahmen etabliert. Bei der Herstellung unserer Produkte achten wir auf eine hohe Ressourceneffizienz, Recycling und möglichst umwelt- bzw. sozialverträgliche Lösungen. Darüber hinaus führen wir Lieferantbefragungen zu den Themen Umwelt, Konformität mit Gesetzen und Richtlinien und Arbeitssicherheit & Gesundheit durch.

Im Jahr 2015 wurde der Bereich „Corporate Social Responsibility“ ergänzt, der seit Anfang 2016 zusammen mit unserem Verhaltenskodex bei unseren regelmäßigen Abfragen an potenzielle Lieferanten weitergereicht wird. Wir fördern damit unsere Standards entlang der vorgeschalteten Lieferkette. Themen wie „Conflict Minerals“, RoHS und REACH werden von einer internen Stelle bei SÜSS MicroTec bearbeitet. Unsere allgemeinen Einkaufsbedingungen greifen das Thema „gesellschaftliche Verantwortung“ ebenfalls auf. Dort wird vor allem auf die Einhaltung von Menschenrechten und Arbeitsnormen, das Verbot von Diskriminierung sowie Zwangs- und Kinderarbeit, auf Antikorruption und ethische und ökologische Beschaffung eingegangen.

Ziele

In den Geschäftsjahren 2016 und 2017 gab es keine gemeldeten Verstöße oder Beschwerden von Kunden oder Lieferanten im Hinblick auf die Verletzung von Menschenrechten. Unser Ziel ist es, dies beizubehalten.

Risiken

Durch gezielte Schulungen und Mitarbeiteraufklärung wollen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisieren, dass im Falle von (potenziellen) Verstößen die internen Kontrollmechanismen beziehungsweise das Whistleblowing-System genutzt werden. Im Falle von Verstößen gegen die Menschenrechte könnte dem Unternehmen ein Reputationsverlust drohen, einhergehend mit einem möglichen Verlust von Marktanteilen und möglicherweise von Mitarbeitern. Operativ könnte es zudem Engpässe bei der Materialversorgung geben, falls aufgrund eines Vorfalls ein Lieferant von uns gesperrt würde.

BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG

Alle Mitarbeiter müssen Situationen vermeiden, in denen ihre persönlichen, anderweitigen wirtschaftlichen oder finanziellen Interessen mit denen der SÜSS MicroTec-Gruppe in Konflikt geraten. Schon der Anschein eines Interessenkonflikts kann den Ruf oder die Interessen der SÜSS MicroTec schädigen und sollte bereits im Ansatz vermieden werden. Geschäftsentscheidungen werden grundsätzlich immer zum Wohle des Unternehmens getroffen. Geschäftsmoral und Integrität sichern unsere Glaubwürdigkeit. Es ist selbstverständlich, dass alle Konzerngesellschaften und -mitarbeiter die Gesetze und Regelungen der Staaten, in denen sie tätig sind, befolgen und ihre Verpflichtungen in zuverlässiger Art und Weise erfüllen. Sie müssen in allen Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit Aufrichtigkeit und Fairness beweisen. Gleiches erwarten wir von unseren Partnern.

Wir sind überzeugt, dass ethische und ökonomische Werte voneinander abhängig sind und dass die Geschäftswelt um einen fairen Umgang miteinander bemüht sein und im Rahmen der vorgegebenen Normen handeln sollte. Unsere Grundsätze hierzu finden sich im Verhaltenskodex und sind jedem Mitarbeiter sowie Kunden und Lieferanten zugänglich.

Zwar erwartet die Gesellschaft von allen Mitarbeitern ehrliches und ethisches Verhalten in allen Aspekten unseres Geschäfts, besonders hohe Anforderungen stellt sie jedoch an ihre Führungskräfte, von denen ein Höchstmaß an Integrität und Rechtschaffen-

heit erwartet wird, da sie den Führungsstil vorgeben und eine Vorbildfunktion für alle Mitarbeiter ausüben.

Dies erfordert ein ehrliches und aufrichtiges Verhalten unter Beachtung der gebotenen Vertraulichkeit bestimmter Unternehmensinformationen sowie die Einhaltung aller einschlägigen Gesetze, Vorschriften, Regelungen und der Satzung, der Vorschriften geltender Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze sowie die Vermeidung von Interessenkonflikten und Wettbewerbsvorteilen durch rechtswidrige oder unethische Geschäftspraktiken.

Das Unternehmen gewinnt seine Aufträge auf faire Art und Weise durch Kundenorientierung, Innovationen und technologisch führende Produkte. Es ist den Mitarbeitern nicht erlaubt, im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für SÜSS MicroTec, direkt oder indirekt, ungerechtfertigte Vorteile anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren. Weder Geldzahlungen noch andere Zuwendungen dürfen geleistet werden, wenn diese dazu geeignet sind, Entscheidungen zu beeinflussen und/oder ungerechtfertigt einen Vorteil zu erlangen.

Ziele

Unser Ziel im Hinblick auf die Bekämpfung von Korruption und Bestechung ist eine hohe Akzeptanzquote unseres Verhaltenskodex. Dies gilt nicht nur für die deutschen Standorte, sondern für alle weltweiten Tochterunternehmen. Zum 31.12.2017 hatte das Unternehmen circa 850 Mitarbeiter (inklusive Teilzeitkräften und Auszubildenden). Zu diesem Zeitpunkt lagen uns schriftliche Anerkennungsschreiben zum Verhaltenskodex von 805 Mitarbeitern weltweit vor. Hieraus ergibt sich eine Rücklaufquote zum 31.12.2017 von rund 94,7 Prozent. Im Geschäftsjahr 2016 lag diese Quote zum Jahresende deutlich unter 90 Prozent. Durch Fluktu-

ationen in der Belegschaft wird es kaum möglich sein, zu jedem Zeitpunkt eine Quote von 100 Prozent zu erreichen, deshalb streben wir für das Folgejahr zunächst eine Rücklaufquote von mindestens 95 Prozent an.

Risiken

Bei Verstößen gegen die Rechtsvorschriften im Hinblick auf Bestechung und Korruption könnten dem Unternehmen neben einem erheblichen Reputationsverlust empfindliche Bußgeldzahlungen oder in Extremfällen Haftstrafen für Mitarbeiter, die gegen gesetzliche Regelungen verstoßen haben, drohen. Im Unternehmen gab es in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 keine Vorfälle, Meldungen oder Gerichtsverfahren im Hinblick auf Korruption oder Bestechung. Unser Ziel ist es, durch Schulungen und Aufklärung diese Quote bei null zu halten.

SOZIALES

Als mittelständisch geprägtes Unternehmen mit begrenzten Ressourcen legt SÜSS MicroTec seinen Fokus auf die Geschäftstätigkeit – die Fertigung von Maschinen. Eine politische Einflussnahme auf kommunaler oder höherer Ebene findet nicht statt. Wir leisten grundsätzlich keine Spenden und Sponsoring-Maßnahmen für politische Parteien oder parteiähnliche Organisationen im In- und Ausland. Spenden und Sponsoring-Maßnahmen für Sportveranstaltungen, Wohltätigkeitsveranstaltungen oder Ähnliches bedürfen der Genehmigung durch den Vorstand und werden sehr vereinzelt und nur in kleinem Rahmen durchgeführt. Nennenswerte Ziele, Chancen oder Risiken ergeben sich aus dem Aspekt Soziales nicht.

ÜBERSICHT ÜBER DIE ASPEKTE UND ZIELE

	ZIELE 2018	STAND 2017
ASPEKTE / ZIELE		
Umweltbelange	Verringerung des Energieeinsatzes (gemessen in CO ₂ -Äquivalenten) um 16–18% (2012–2020)	Verringerung des Energieeinsatzes (gemessen in CO ₂ -Äquivalenten) um 16-18% (2012–2020; Stand 2016)
Arbeitnehmerbelange	Anzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle verringern; Ausgaben für Weiterbildung je Mitarbeiter in Deutschland durch sinnvolle Maßnahmen erhöhen	Anzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle = 7; Ausgaben für Weiterbildung je Mitarbeiter in Deutschland: rund 480 Euro
Achtung der Menschenrechte	Anzahl der gemeldeten Verstöße = 0	Anzahl der gemeldeten Verstöße = 0
Bekämpfung von Korruption und Bestechung	Annahmequote Compliance-Dokumente >95%	Annahmequote Compliance-Dokumente >94,7%
Soziales	Keine Ziele definiert, da „Soziales“ kein wesentlicher Aspekt ist	–

ZUSAMMEN- GEFASSTER LAGEBERICHT

Wirtschaftsbericht	60
Geschäftstätigkeit, Unternehmenssteuerung und strategische Ausrichtung	60
Wirtschaftliches Umfeld	63
SÜSS MicroTec in Zahlen	64
Die Holding – SÜSS MicroTec SE	74
Übernahmerechtliche Angaben gemäß § 289a HGB und § 315a HGB	76
Konzernerklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f und § 315d HGB	78
Nichtfinanzielle Konzernerklärung gemäß § 315b HGB	82
Vergütungsbericht	83
Vergütung des Vorstands	83
Vergütung des Aufsichtsrats	89
Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des SÜSS MicroTec-Konzerns	90
Prognosebericht	101
Branchenspezifische Rahmenbedingungen	101
Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten	102
Endogene Indikatoren	104
Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns – Ausblick 2018	104
Zukunftsgerichtete Angaben	105

WIRTSCHAFTSBERICHT

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT, UNTERNEHMENS- STEUERUNG UND STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

Der SÜSS MicroTec-Konzern (nachfolgend SÜSS MicroTec) entwickelt, fertigt und vertreibt Maschinen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigen Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt steht die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung. Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wobei die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Optimierung des Kundennutzens bildet und nutzt.

Der Konzern ist zum 31. Dezember 2017 in vier Segmente eingeteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren Teileinheiten besteht.

LEITUNG UND KONTROLLE – VERGÜTUNGSSTRUKTUR FÜR DIE ORGANMITGLIEDER

Die Leitung der SÜSS MicroTec SE entspricht dem dualistischen System. Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Die Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat wird im Abschnitt Konzernerklärung zur Unternehmensführung gem. § 289f und § 315d HGB dargestellt.

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Festvergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbeträgen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit privater

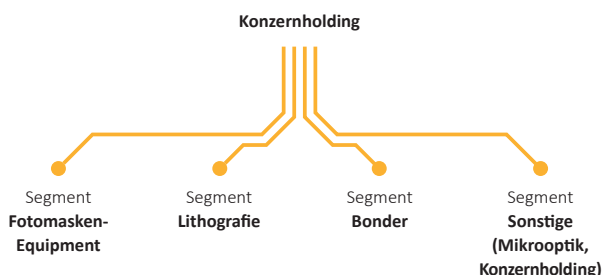
Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbeträge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Einzelnen früheren Mitgliedern des Vorstands sind in der Vergangenheit zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen gemacht worden. Die variable Vergütung enthält kurzfristige und auch langfristige Komponenten, nähere Hinweise hierzu sind im Vergütungsbericht zu finden.

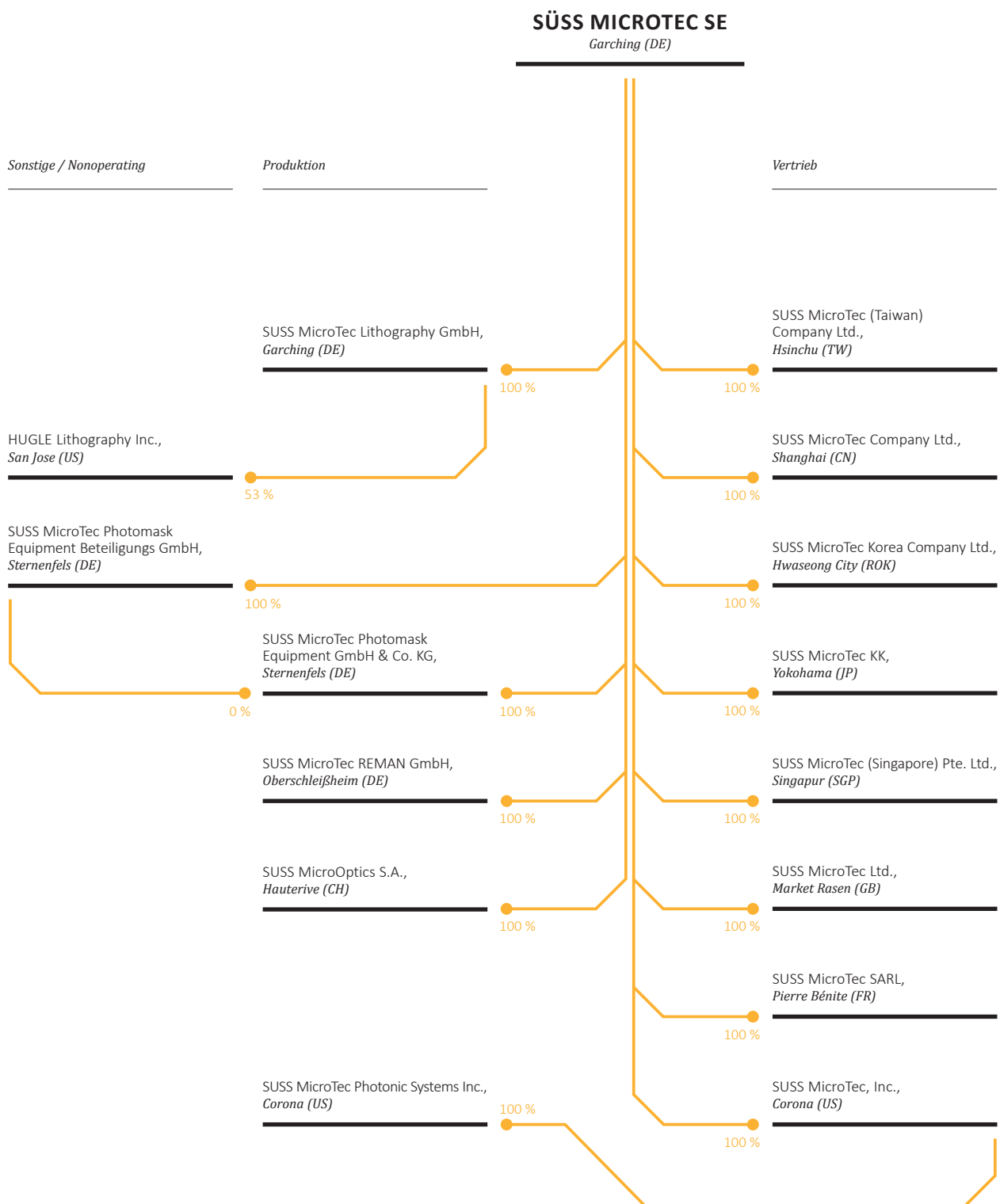
Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec SE geregelt. Gemäß § 19 der Satzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 2.000 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an seiner Verantwortung und seinem Tätigkeitsumfang orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 60.000 €, sein Stellvertreter 50.000 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 45.000 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

RECHTLICHE KONZERNSTRUKTUR

Die SÜSS MicroTec SE (nachfolgend auch „das Unternehmen“) entstand am 09.08.2017 durch Handelsregistereintragung im Wege einer formwechselnden Umwandlung aus der SÜSS MicroTec AG mit Sitz in Garching. Die rechtliche Konzernstruktur besteht unverändert aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec SE als Management- und Finanzierungsholding, sowie den mehrheitlich im Eigentum der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebs- und Servicetätigkeiten für den Konzern organisiert. SÜSS MicroTec verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Japan, China, Singapur, Korea und Taiwan.

SEGMENTSTRUKTUR





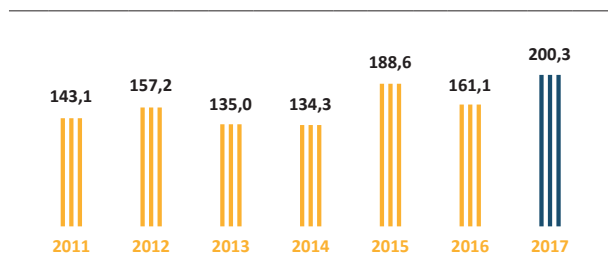
UNTERNEHMENSSTEUERUNG, ZIELE UND UNTERNEHMENSSTRATEGIE

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmärkte in der Industrie der Halbleiterausrüster als Strategie. Ziel ist es, durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top-3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends und zukunftssträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

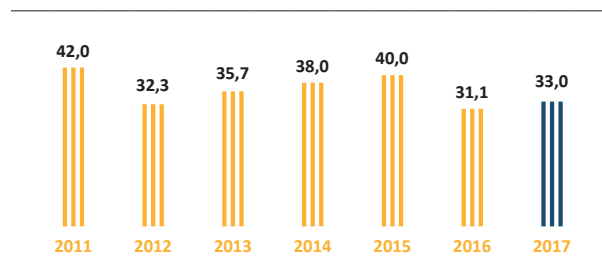
Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere am Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Leistungsfähigkeit der Segmente wird dabei vor

allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellungskosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segmentergebnisses enthält auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente dem operativen Ergebnis (EBIT) sowie dem EBITDA (Ergebnis vor Abschreibung, Zinsen und Steuern) des Konzerns. Eine weitere Steuerungskennzahl ist die Nettoliquidität (flüssige Mittel zuzüglich verzinslicher Wertpapiere und abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt. In der nachfolgenden Darstellung ist die Entwicklung wichtiger Kennzahlen seit 2011 dargestellt.

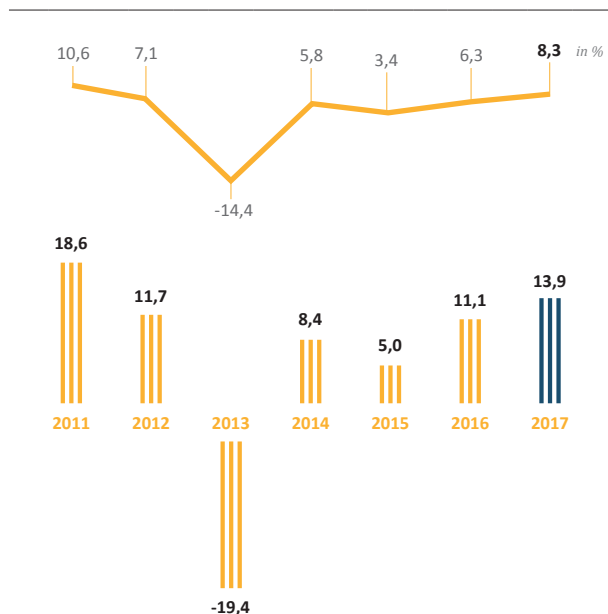
AUFTRAGSEINGANG in Mio. €



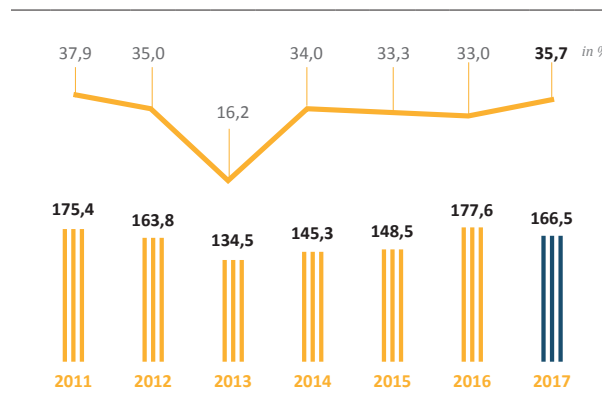
NETTOLIQUIDITÄT in Mio. €



EBIT in Mio. € **UND EBIT-MARGE¹** in %



UMSATZ in Mio. € **UND BRUTTOMARGE** in %



¹ EBIT 2013 enthält Einmalkosten für die Refokussierung der Produktlinie permanente Bonder in Höhe von 13,2 Mio. €.

WIRTSCHAFTLICHES UMFELD

ANHALTENDE WELTWEITE WACHSTUMSIMPULSE

Die Weltwirtschaft befindet sich nunmehr seit mehr als fünf Jahren im Aufwärtstrend. Im Sommerhalbjahr 2017 ist das Expansions-tempo gemäß dem ifo Institut München (ifo Konjunkturprognose, 14. Dezember 2017) merklich gestiegen und das reale Bruttoinlandsprodukt konnte in den beiden Sommerquartalen 2017 um jeweils 0,9 Prozent gegenüber Vorjahr zulegen. Sowohl in den Industrieländern als auch in den Schwellenländern steigerte sich die industrielle Produktion deutlich. Zudem trug der weltweite Warenhandel, insbesondere mit den Schwellenländern, zur allgemeinen Wirtschaftsbelebung bei. Darüber hinaus ist der seit langem befürchtete Wachstumseinbruch in China weiterhin ausgeblieben und die inländische Nachfrage erwies sich als robust.

Auch in der Eurozone hält das starke Wachstum an. Das reale Bruttoinlandsprodukt wird gemäß der Eco-Studie (Eurozone economic outlook, 10. Januar 2018) führender Wirtschaftsforschungsinstitute im vierten Quartal 2017 sowie im ersten Quartal 2018 um jeweils 0,6 Prozent zulegen können und damit die gleiche Expansionsgeschwindigkeit wie in den vier Quartalen davor beibehalten können. Getragen wird das Wachstum im Wesentlichen durch hohe Investitionen und die Zunahme des Privatkonsums. Für 2017 gehen die Experten von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in der Eurozone um 2,4 Prozent aus.

Gemäß dem ifo Institut stehen in Deutschland die Zeichen nunmehr seit dem Jahr 2013 auf Expansion. Das Wirtschaftswachstum beschleunigte sich zuletzt im Geschäftsjahr 2017 deutlich gegenüber den Vorjahren. Insbesondere die deutsche Industrie trug zu diesem Trend bei. Mit Ausnahme des staatlichen Konsums wirkten die binnenwirtschaftlichen Kräfte weiterhin positiv, wohingegen die Impulse aus dem Ausland noch deutlich zugenommen haben. Davon profitierten nicht zuletzt die vielen exportorientierten deutschen Unternehmen. Nach einem Plus von 1,9 Prozent im Jahr 2016 wird für 2017 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 Prozent erwartet.

REKORDUMSATZ IM HALBLEITERMARKT

Das Geschäftsjahr 2017 war ein sehr starkes Jahr für die gesamte Halbleiterbranche. Der weltweite Markt für Halbleiter wuchs gegenüber 2016 um mehr als 20 Prozent und erreichte ein Volumen von rund 419 Mrd. USD (Quelle: Gartner, 4. Januar 2018). Insbesondere der Markt für Speicherbausteine, welcher rund

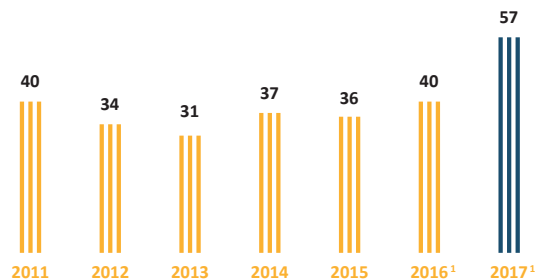
31 Prozent des gesamten Halbleitermarktes ausmacht, konnte aufgrund der sehr hohen Nachfrage deutlich zulegen. Die Preise für NAND-Speicher stiegen um rund 17 Prozent, die Preise für DRAM sogar um 44 Prozent. Der Speichermarkt wird weiterhin von zehn großen Unternehmen dominiert, welche in Summe einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent repräsentieren. Neben dem klassischen Halbleitermarkt entwickelte sich auch der Markt für mikroelektromechanische Systeme (MEMS) weiterhin sehr positiv.

WACHSTUM IM SEGMENT HALBLEITEREQUIPMENT

Nach aktuellen Schätzungen des Branchenverbands SEMI (SEMI Data Projects, 2. Januar 2018) wuchs der Markt für Halbleiter-Equipment im Jahr 2017 um rund 41 Prozent gegenüber 2016 und erreichte damit ein Gesamtvolumen von rund 57 Mrd. USD. Dies markiert einen neuen Rekordwert nach dem bisherigen Höchststand von 47,7 Mrd. USD im Jahr 2000. Nachdem im Jahr 2016 die größten Investments in Taiwan getätigt wurden, lag der regionale Investitionsschwerpunkt im Jahr 2017 in Korea, welches gegenüber 2016 einen Zuwachs von rund 128 Prozent auf 17,9 Mrd. USD verzeichnete. Taiwan folgt mit einem Volumen von 12,6 Mrd. USD auf dem zweiten Platz. Insgesamt verzeichneten alle Regionen weltweit ein verstärktes Investitionsverhalten im Jahr 2017.

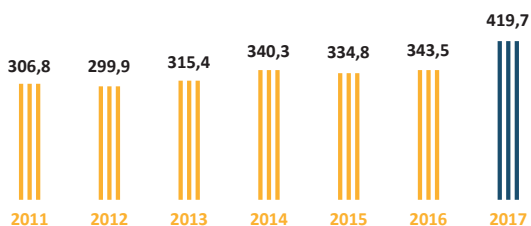
Der für SÜSS MicroTec relevante Spezialbereich Wafer-Level-Packaging and -Assembly konnte laut SEMI (SEMI Equipment Forecast, 12. Dezember 2017) im Geschäftsjahr 2017 um 25,8 Prozent auf 3,8 Mrd. USD zulegen. Im Vorjahr lag der Zuwachs noch bei rund 3,9 Prozent. Nach Schätzungen von Gartner (2. August 2017) lag das Wachstum für den Bereich Wafer-Fab-Equipment einschließlich Wafer-Level-Packaging im Jahr 2017 bei 17,9 Prozent und erreichte damit ein Marktvolumen von 43,7 Mrd. USD.

UMSATZENTWICKLUNG BEI HALBLEITER-EQUIPMENT¹ in Mrd. USD



¹ Inkl. Wafer-Level-Packaging-Equipment.
Quelle: SEMI, 2. Januar 2018

UMSATZENTWICKLUNG IM HALBLEITERMARKT in Mrd. USD



Quelle: Gartner, 4. Januar 2018

SÜSS MICROTEC IN ZAHLEN

ERTRAGSLAGE: AUFTRAGSEINGANG, UMSATZ UND EBIT

Vergleich Gesamtjahreszahlen 2017 – Prognose 2017

Im Prognosebericht des Lageberichts 2016 stellte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2017 einen Konzernumsatz von 160 Mio. € bis 170 Mio. € sowie ein Konzernergebnis (EBIT) in der Bandbreite von 9 Mio. € bis 13 Mio. € in Aussicht. Die Umsatz- und Ergebnisprognose wurde während des Geschäftsjahres 2017 zweimal angepasst, zunächst im Rahmen der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal 2017 im April 2017. Die erwarteten Umsatz- und Ergebnisbandbreiten wurden auf 170 Mio. € bis 180 Mio. € bzw. 13 Mio. € bis 17 Mio. € angehoben. Die zweite Anpassung der Erwartungen erfolgte im August 2017, zu diesem Zeitpunkt wurde die EBIT-Erwartung aufgrund eines Sonderertrags auf 15 Mio. € bis 19 Mio. € angehoben. SÜSS MicroTec schloss das Geschäftsjahr 2017 mit einem Umsatz in Höhe von 166,5 Mio. € und damit unter den eigenen zwischenzeitlich angehobenen Erwartungen. Das EBIT erreichte einen Wert von 13,9 Mio. € und lag damit ebenfalls unter der eigenen Erwartung vom August 2017. Der Grund für das Verfehlen der Umsatz- und Ergebnisziele lag in der Verschiebung der Umsatzrealisierung einzelner Maschinen, welche zum Jahresende bereits an den Kunden ausgeliefert waren, deren Endabnahme und damit die Voraussetzung für die Umsatzrealisierung aber zum 31.12.2017 noch ausstand.

in Mio. €	1. Prognose 2017	2. Prognose 2017	3. Prognose 2017	Ergebnis 2017
Umsatz	160–170	170–180	170–180	166,5
EBIT	9–13	13–17	15–19	13,9

Unternehmensentwicklung im Jahr 2017

Der Auftragseingang von SÜSS MicroTec belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf insgesamt 200,3 Mio. €, während im Vorjahr ein Auftragseingang von 161,1 Mio. € erzielt wurde. Die prognostizierte Entwicklung des Auftragseingangs wurde somit im Jahr 2017 deutlich übertroffen. Insbesondere das vierte Quartal 2017, mit einem Auftragseingang von 68,9 Mio. €, hatte großen Einfluss auf den Jahreswert. Damit lag der Auftragseingang 2017 rund 24,3 Prozent über dem Auftragseingang des Vorjahres. Zum 31. Dezember 2017 ergab sich folglich ein hoher Auftragsbestand von 133,4 Mio. €, der mit 31,4 Prozent deutlich über dem Auftragsbestand des Vorjahres (101,5 Mio. €) lag. Das Verhältnis von neu eingegangenen Aufträgen zu realisierten Umsätzen (Book-to-Bill-Ratio) lag bei 1,2 nach 0,9 im Vorjahr.

Die Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns zeigte im Geschäftsjahr 2017 trotz eines stichtagsbedingten Umsatzrückgangs um 6,2 Prozent einen erheblichen Ergebniszuwachs um 25,2 Prozent. Die Umsatzerlöse sanken im Vergleich zum Vorjahr von 177,6 Mio. € auf 166,5 Mio. €, während das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 11,1 Mio. € auf 13,9 Mio. € erhöht werden konnte. Das EBIT des Geschäftsjahres 2017 enthält einen Sonder-

effekt in Höhe von 1,95 Mio. € aus der Vereinnahmung von Lizenzgebühren im Segment Fotomaschinen-Equipment. Diese Erträge betreffen Erlöse aus einem Lizenzabkommen zur Vermarktung einer von SÜSS MicroTec entwickelten Technologie zum Reinigen von Wafern.

Das umsatzstärkste Segment von SÜSS MicroTec, die Lithografie, verzeichnete einen Umsatzrückgang um 15,7 Prozent. Der Hauptgrund hierfür sind fehlende Umsatzbeiträge aus der Produktlinie UV-Projektionscanner, welche 2016 einen erheblichen Umsatzanteil beisteuerten. Der Anteil der Umsätze des Segments Lithografie betrug 2017 rund 68 Prozent der gesamten Konzernumsätze. Im Segment Bonder konnte ein deutlicher Umsatzanstieg von 14,0 Mio. € auf 22,1 Mio. € erreicht werden. Im Segment Fotomaschinen-Equipment ergaben sich kaum Veränderungen im Umsatz und im Segment Sonstiges zeigte sich durch die gute Entwicklung des Geschäfts der SÜSS MicroOptics ein Umsatzanstieg um 17,6 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Rohertrag von 59,5 Mio. € erzielt, was einer Rohertragsmarge von 35,7 Prozent entspricht. Im Vorjahr betrug der Rohertrag 58,6 Mio. € bzw. 33,0 Prozent. Die Gründe für die verbesserte Rohertragsmarge liegen im Wesentlichen in der Verbesserung der Ertragslage im Segment Bonder, hier konnte durch Skaleneffekte, bedingt durch den deutlich höheren Umsatz sowie durch den gestiegenen Umsatzanteil mit temporären Bondsystemen, welche eine gute Marge haben, der Rohertrag deutlich gesteigert werden. Wie bereits im Halbjahresbericht 2017 beschrieben, gab es darüber hinaus einzelne Aufträge mit überdurchschnittlicher Marge aus dem Bereich permanentes Bonden. In den anderen Bereichen ist die Rohertragsmarge nahezu stabil geblieben.

Die Vertriebskosten des Geschäftsjahres waren leicht rückläufig und lagen bei 19,6 Mio. € (Vorjahr: 20,5 Mio. €), was – in Relation zum erzielten Umsatz – einer Aufwandsquote von 11,8 Prozent (Vorjahr: 11,6 Prozent) entspricht.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten sind im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut angestiegen und beliefen sich auf 15,2 Mio. € (Vorjahr: 14,1 Mio. €). SÜSS MicroTec hat – wie geplant – seine Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung weiter ausgebaut.

Die Verwaltungskosten verringerten sich leicht von 13,6 Mio. € im Vorjahr auf nun 13,4 Mio. € und entsprechen damit einer Aufwandsquote von 8,1 Prozent (Vorjahr: 7,7 Prozent).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich im Geschäftsjahr auf 6,3 Mio. € (Vorjahr: 4,3 Mio. €). Sie beinhalten – wie auch im Vorjahr – Fremdwährungsgewinne, die sich aus der Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro ergeben haben. Daneben konnten 2017 erstmalig Lizenzerträge aus der Übertragung von Prozess-Know-how an einen japanischen Kooperationspartner in Höhe von 1,95 Mio. € erzielt werden. Die Lizenzerträge betreffen Erlöse aus einem Lizenzabkommen zur Vermarktung einer von SÜSS MicroTec entwickelten Technologie zum Reinigen von Wafern.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich 2017 auf 3,8 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €) und beinhalten vor allem Aufwendungen aus Fremdwährungsumrechnungen sowie Aufwendungen für sonstige Steuern.

Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 13,9 Mio. €. Im Jahr 2016 wurde ein EBIT von 11,1 Mio. € erzielt.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen beliefen sich auf 4,1 Mio. € (Vorjahr: 4,2 Mio. €). Damit ergab sich ein EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 18,0 Mio. € (Vorjahr: 15,3 Mio. €).

Das Finanzergebnis belief sich 2017 auf -0,15 Mio. € (nach -0,63 Mio. € im Vorjahr). Die Finanzerträge in Höhe von 57 Tsd. € (Vorjahr: 91 Tsd. €) resultierten im Wesentlichen aus Zinserträgen und Wertpapiererträgen. Die Zinsen für Bankverbindlichkeiten betrafen im Geschäftsjahr im Wesentlichen die Grundstücksfinanzierung in Garching (Darlehensstand zum 31. Dezember 2017: 3.500 Tsd. €). Im Vorjahr entfielen Zinsaufwendungen von 187 Tsd. € auf die Grundstücksfinanzierung Garching und 42 Tsd. € auf die Grundstücksfinanzierung Sternenfels. Das Darlehen für die Grundstücksfinanzierung Sternenfels war im ersten Halbjahr 2016 gekündigt und zum 30. Juni 2016 komplett getilgt worden. In dem Zusammenhang wurden im Vorjahr Finanzaufwendungen von 434 Tsd. € für die Ablösung des damit verbundenen Zinsswaps erfasst.

Das Konzernergebnis vor Steuern von 13,8 Mio. € ist mit einem Steueraufwand von 7,0 Mio. € belegt, was einer durchschnittlichen Steueraufwandsquote von rund 50,0 Prozent entspricht. Grund für den – in Relation zum Gewinn vor Steuern – hohen Steueraufwand sind vor allem im Geschäftsjahr 2017 erneut aufgelaufene Verluste ausländischer Konzerngesellschaften (insbesondere in den USA), für die unter Berücksichtigung der aktuellen Konzernplanung (analog zu den Vorjahren) keine aktiven latenten Steuern angesetzt wurden.

Im Vorjahr war das Konzernergebnis vor Steuern von 10,5 Mio. € mit einem Steueraufwand von 5,5 Mio. € belegt, was einer durchschnittlichen Steueraufwandsquote von rund 52,4 Prozent entsprach. Grund für den – in Relation zum Gewinn vor Steuern – hohen Steueraufwand waren ebenfalls im Geschäftsjahr 2016 aufgelaufene Verluste ausländischer Konzerngesellschaften (insbesondere in den USA), für die keine aktiven latenten Steuern angesetzt wurden.

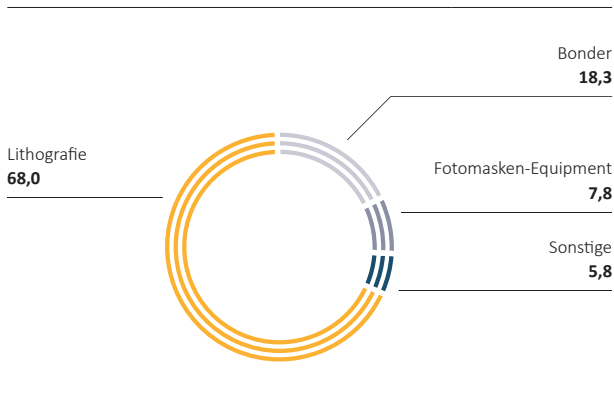
Im Konzern ergab sich ein Gewinn nach Steuern von 6,7 Mio. € (Vorjahr: 5,0 Mio. €). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug 0,35 € nach 0,26 € im Vorjahr.

ENTWICKLUNG IN DEN EINZELNEN SEGMENTEN

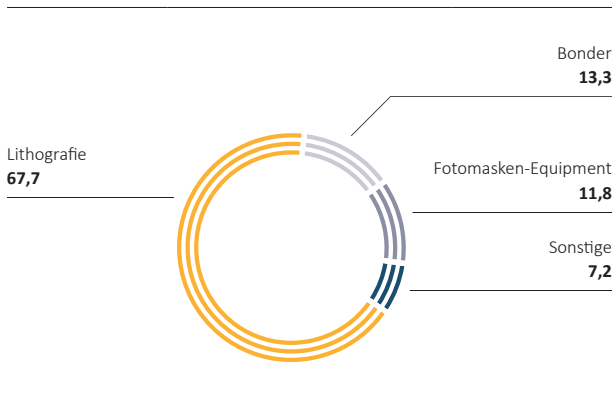
Lithografie

Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask-Aligner, UV-Projektions-scanner, Laser-Processing-Tools sowie Belacker und Entwickler. Die Fertigung dieser Produktlinien ist in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Sternenfels angesiedelt. Die Lithografiesparte wurde im ersten Quartal 2012 mit der Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc. (firmiert heute unter SUSS MicroTec Photonic Systems Inc.) verstärkt. Das Tochter-Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Corona, Kalifornien, USA. Das Segment Lithografie ist mit einem Umsatzanteil von mehr als 67 Prozent der größte Bereich der SÜSS MicroTec-Gruppe. Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt werden, gehen im Wesentlichen in die Endmärkte Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter (LED) sowie 3D-Integration.

AUFTRAGSEINGANG NACH SEGMENTEN in %



UMSATZ NACH SEGMENTEN in %



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Segment Lithografie einen Auftragseingang von 136,2 Mio. € (Vorjahr: 105,0 Mio. €) sowie einen Umsatz von 112,8 Mio. € (Vorjahr: 133,8 Mio. €). Dies entspricht einem Rückgang im Umsatz von 15,7 Prozent sowie einem Plus im Auftragseingang von 29,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der deutliche Anstieg im Auftragseingang wurde insbesondere durch die Produktlinien Mask-Aligner und Belacker/Entwickler erzielt, die gegenüber 2016 jeweils deutlich zweistellige Zuwächse im Auftragseingang verzeichneten. Die insgesamt geringeren Umsätze im Segment Lithografie resultierten aus den rückläufigen Umsätzen der Produktlinie UV-Projektionscanner, welche im Geschäftsjahr 2017 nur einen kleinen Umsatzbeitrag leistete, sowie aus der Normalisierung der Umsätze im Bereich Belacker/Entwickler. Hier gab es nach den sehr hohen Auftrags-eingängen im vierten Quartal 2015 einen sprunghaften Anstieg im Umsatz mit 200-mm-Tools im Geschäftsjahr 2016. Im Auftrags-eingang 2016 und entsprechend im Umsatz 2017 gab es neben der allgemein guten Geschäftsentwicklung keinen vergleichbaren Effekt. Zudem gab es zum Stichtag 31.12.2017 Umsatzverschiebungen in das Geschäftsjahr 2018 aufgrund von bis dahin fehlenden Kundenendabnahmen.

Die Rohertragsmarge im Segment Lithografie lag im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 31,5% auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2016 belastete die negative Marge für UV-Projektionscanner das Ergebnis des Segments Lithografie. Aufgrund der rückläufigen Umsätze sowie des Produktmix konnte im Geschäftsjahr 2017 keine Verbesserung der Rohertragsmarge erreicht werden.

Das Segment Lithografie steuerte ein Segmentergebnis in Höhe von 6,3 Mio. € (Vorjahr: 13,2 Mio. €) zum Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei. Damit ergibt sich für das Segment Lithografie eine EBIT-Marge von 5,6 Prozent, die sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert hat (EBIT-Marge des Vorjahres: 9,8 Prozent). Ein wesentlicher Grund für den Rückgang des EBIT ist das deutlich niedrigere Umsatzniveau im Vergleich zum Vorjahr. Zudem lagen die Aufwendungen im Forschungs- und Entwicklungsbereich 2017 deutlich über dem Wert des Geschäftsjahres 2016, insbesondere die Kosten für die Neuentwicklung der UV-Projektionscanner fallen hier ins Gewicht. Im Geschäftsjahr 2017 wurde darüber hinaus die Personaldecke im Segment Lithografie deutlich verstärkt, nicht zuletzt, um dem gestiegenen Auftragseingang Rechnung zu tragen.

KENNZAHLEN LITHOGRAFIE

in Mio. €	2017	2016
Auftragseingang	136,2	105,0
Segmentumsatz	112,8	133,8
Segmentergebnis EBIT	6,3	13,2
Nettovermögen	60,7	59,3

Bonder

Das Segment Bonder umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Bonder. Die Fertigung ist an unserem größten Standort in Sternenfels angesiedelt. Zu den adressierten Märkten der Bonder zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.

Das Segment Bonder entwickelte sich sowohl im Auftragseingang mit 36,7 Mio. € (Vorjahr: 18,6 Mio. €) als auch im Umsatz mit 22,1 Mio. € (Vorjahr: 14,0 Mio. €) sehr positiv. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden gegenüber 2016 in der Produktlinie temporäres Bonden deutlich mehr Aufträge verbucht. In dieser Produktlinie ist es uns gelungen, Aufträge für die Volumenproduktion bei der 3D-Integration zu gewinnen. Diese hohen Auftragseingänge konnten den rückläufigen Auftragseingang im Bereich permanentes Bonden mehr als ausgleichen und führten in Summe zu einem gesteigerten Auftragseingang im Segment Bonder.

Das Rohergebnis des Segments Bonder war im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut positiv. Die Rohertragsmarge verbesserte sich deutlich von 36,3 Prozent auf 45,1 Prozent. Die Margen in den Bereichen temporäres Bonden und Debonden sowie das Geschäft mit permanenten Bondensystemen verbesserten sich nachhaltig. Im Segment Bonder ergab sich erstmals ein positives Segmentergebnis (EBIT) von 3,3 Mio. € nach -1,7 Mio. € im Vorjahr. Das EBIT verbesserte sich allgemein aufgrund von Skaleneffekten, bedingt durch den deutlich höheren Umsatz, sowie insbesondere dem gestiegenen Umsatzanteil mit temporären Bondensystemen, welche eine gute Marge aufweisen. Wie bereits im Halbjahresbericht 2017 beschrieben, gab es darüber hinaus einzelne Aufträge mit überdurchschnittlicher Marge aus dem Bereich permanentes Bonden.

Das deutlich gestiegene Nettovermögen des Segments Bonder resultiert aus der Zunahme des Vorratsvermögens, hierbei spielen insbesondere temporäre Bondensysteme, welche sich zum Stichtag noch im Aufbau befanden, eine Rolle.

KENNZAHLEN BONDER

in Mio. €	2017	2016
Auftragseingang	36,7	18,6
Segmentumsatz	22,1	14,0
Segmentergebnis EBIT	3,3	-1,7
Nettovermögen	17,7	5,1

Fotomaschinen-Equipment

Das Segment Fotomaschinen-Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen, die auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomaschinen für die Halbleiterindustrie spezialisiert sind, und ist ebenfalls am Standort Sternenfeld angesiedelt. Zu den adressierten Märkten des Segments Fotomaschinen-Equipment zählt die Halbleiterindustrie, hier ist SÜSS MicroTec überwiegend im Frontend tätig.

Das Segment Fotomaschinen-Equipment entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr im Auftragseingang schwächer als im Vorjahr. Der Auftragseingang lag Ende Dezember 2017 bei 15,7 Mio. € nach einem hohen Wert im Vorjahr von 26,3 Mio. €. Der Segmentumsatz blieb mit 19,7 Mio. € hingegen nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtmarkt ist vergleichsweise klein und so werden pro Jahr nur ca. drei bis fünf Maschinen gefertigt und verkauft. Die Geräte zur Reinigung von Fotomaschinen sind sehr komplex und hochwertig, SÜSS MicroTec hält in diesem Bereich einen Marktanteil von rund 80 Prozent. Verschiebt sich der Verkauf einer Maschine über einen Berichtsstichtag hinaus, so kann es von Quartal zu Quartal, aber auch von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr zu nicht unerheblichen Schwankungen im Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis kommen.

Die Rohertragsmarge erhöhte sich im Geschäftsjahr 2017 auf 36,8 Prozent. Im Geschäftsjahr 2016 konnte ein Wert von 32,7 Prozent erreicht werden. Die Rohertragsmarge unterliegt ähnlichen Schwankungen wie Auftragseingang und Umsatz, da sie von wenigen Einzelaufträgen bestimmt wird. Das Segment Fotomaschinen-Equipment trug mit einem Segmentergebnis von 5,1 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €) erheblich zum Konzern-EBIT bei. Die EBIT-Marge lag bei 25,9 Prozent und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (EBIT-Marge 2016: 9,2 Prozent) erheblich verbessert. In diesem Segment konnte im Geschäftsjahr 2017 ein Sonderertrag in Höhe von 1,95 Mio. € aus der Erzielung von Lizenzträgen für die Übertragung von Prozess-Know-how zur Reinigung von Wafern erzielt werden. Ohne den Sonderertrag beträgt die EBIT-Marge rund 15,7 Prozent.

Das deutlich gesunkene Nettovermögen des Segments Fotomaschinen-Equipment resultiert aus dem Rückgang der Forderungen zum Bilanzstichtag sowie dem Zuwachs an erhaltenen Anzahlungen.

KENNZAHLEN FOTOMASKEN-EQUIPMENT

<i>in Mio. €</i>	2017	2016
Auftragseingang	15,7	26,3
Segmentumsatz	19,7	19,7
Segmentergebnis EBIT	5,1	1,8
Nettovermögen	2,4	14,8

Sonstige

Das Segment Sonstige umfasst die Mikrooptik-Aktivitäten am Standort Hauterive, Schweiz, sowie die größtenteils auf Segmentebene nicht zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen.

Der Auftragseingang steigerte sich nochmals leicht von 11,2 Mio. € im Geschäftsjahr 2016 auf 11,7 Mio. € im Jahr 2017. Der Segmentumsatz belief sich auf 11,9 Mio. € nach 10,1 Mio. € im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Größten Anteil am Umsatz und Auftragseingang hatte dabei – wie auch im Vorjahr – das Geschäftsfeld Mikrooptik, das einen externen Auftragseingang von 11,4 Mio. € (Vorjahr: 10,9 Mio. €) sowie im externen Umsatz einen Anstieg von 9,9 Mio. € auf 11,6 Mio. € erzielte. Das EBIT des Segments Sonstige belief sich auf -0,8 Mio. € (Vorjahr: -2,1 Mio. €). Davon entfielen 3,3 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €) auf SÜSS MicroOptics.

KENNZAHLEN SONSTIGE

<i>in Mio. €</i>	2017	2016
Auftragseingang	11,7	11,2
Segmentumsatz	11,9	10,1
Segmentergebnis EBIT	-0,8	-2,1
Nettovermögen	18,3	20,9

ENTWICKLUNG IN DEN WICHTIGSTEN REGIONEN

Asien, EMEA (Europe, Middle East, Africa) und Nordamerika sind die für das Geschäft von SÜSS MicroTec wichtigen Weltregionen. Seit 2016 erfolgt aufgrund der Geringfügigkeit der Umsätze in Japan eine Zusammenfassung dieser Umsätze mit den übrigen Umsätzen der Region Asien.

Die Regionen EMEA und Asien wiesen im Geschäftsjahr 2017 erheblich höhere Auftragseingänge als noch im Geschäftsjahr 2016 aus. In der Region EMEA stieg der Auftragseingang um 5,2 Prozent auf 40,1 Mio. €. In Asien fiel der Zuwachs im Auftragseingang mit einem Plus von rund 57,6 Prozent auf 140,7 Mio. € deutlich höher aus. Asien bleibt mit einem Auftragseingang von konzernweit mehr als 70 Prozent weiterhin die wichtigste Absatzregion für SÜSS MicroTec. In der Region Nordamerika verzeichnete das SÜSS MicroTec im vergangenen Geschäftsjahr einen Rückgang im Auftragseingang. Dieser verringerte sich von 33,7 Mio. € auf 19,5 Mio. €, dies entspricht einem Minus von 42,1 Prozent. Den größten Zuwachs in der Region Asien verzeichnete das Unternehmen durch den Auftragseingang von mehreren temporären Bondsystemen. Zudem konnten insbesondere durch den hohen Auftragseingang im vierten Quartal 2017 in allen drei Segmenten Zuwächse verzeichnet werden.

Betrachtet man den insgesamt gegenüber Vorjahr rückläufigen Umsatz, so ergibt sich nur in der Region Nordamerika ein leichter Zuwachs. Nordamerika verzeichnete einen Umsatzanstieg um 4,8 Prozent auf 26,6 Mio. €. Die Regionen EMEA und Asien verzeichneten gegenüber Vorjahr einen um 10,0 Prozent beziehungsweise um 7,3 Prozent niedrigeren Umsatz. Hauptgrund für die rückläufigen Umsätze in Asien sind die gegenüber 2016 weggefallenen Umsätze mit UV-Projektionsscannern. Insgesamt konnten die höheren Umsätze mit Bondern sowie die leicht angestiegenen Umsätze mit Mask-Alignern den Umsatzrückgang bei den Belackern/Entwicklern sowie den UV-Projektionsscannern nicht vollständig kompensieren.

FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Eine stabile Finanz- und Vermögenslage zeichnet SÜSS MicroTec aus

Die Net-Cash-Position des Konzerns – der Saldo aus flüssigen Mitteln und Finanzverbindlichkeiten – erhöhte sich von 31,1 Mio. € im Vorjahr auf 33,0 Mio. € zum 31. Dezember 2017. Der Bestand an liquiden Mitteln stieg von 35,6 Mio. € im Vorjahr auf 36,5 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres. Die Finanzverbindlichkeiten wurden planmäßig um 1,0 Mio. € auf 3,5 Mio. € reduziert.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 9,4 Mio. € (Vorjahr: -5,5 Mio. €). Grund für den im Vergleich zum Vorjahr deutlich positiven operativen Cashflow war zum einen der hohe Liquiditätszufluss aus Kundenanzahlungen, der sich auf rund 18,1 Mio. € belief. Zum anderen wirkten sich auch die stichtagsbedingt höheren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit rund 5,8 Mio. € positiv auf den Cashflow aus. Darüber hinaus war der operative Cashflow positiv beeinflusst durch das Jahresergebnis, die (stichtagsbedingte) Verringerung der Kundenforderungen und die Erhöhung der Steuerverbindlichkeiten. Ein deutlich negativer Effekt von rund -28,2 Mio. € war hingegen durch den sehr starken Aufbau des Lagerbestands (insbesondere der Materialien und Hilfsstoffe sowie der Fertigerzeugnisse) zu verzeichnen, mit dem dem hohen Auftragsbestand Rechnung getragen wurde.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug -6,5 Mio. € (Vorjahr: -3,6 Mio. €); davon entfielen rund 6,0 Mio. € auf Investitionen in Sachanlagen. Für die Modernisierung eines Applikations-Reinraums am Standort Sternenfels waren bis zum Jahresende 2017 Mittelabflüsse von rund 1,1 Mio. € zu verzeichnen. Weitere 1,9 Mio. € wurden in Reinraumerweiterungen und Umbauten bei der SÜSS MicroOptics, Hauterive, Schweiz, investiert. Für sonstige Umbauten und Modernisierungen der Gebäude in Garching und Sternenfels wurden rund 0,5 Mio. € aufgewendet. An den Produktionsstandorten wurden außerdem Teststände, Maschinen und technische Anlagen für rund 1,3 Mio. € und Hardware für 0,4 Mio. € angeschafft. Die übrigen Investitionen

AUFTRAGSEINGANG NACH REGIONEN in %



UMSATZ NACH REGIONEN in %



betrafen im Wesentlichen Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Software und Lizenzen.

Der Free Cashflow belief sich damit auf 2,9 Mio. €. Im Vorjahr wurde ein Free Cashflow von -9,1 Mio. € erzielt.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf -1,0 Mio. € (Vorjahr: -4,6 Mio. €) und resultiert fast ausschließlich aus den geleisteten planmäßigen Tilgungen in Höhe von insgesamt 1,0 Mio. € für das Bankdarlehen der SÜSS MicroTec SE, das der Finanzierung des Betriebsgrundstücks Garching dient. Im Vorjahr zeigte sich hier darüber hinaus die vorzeitige komplette Tilgung des Bankdarlehens der damaligen SÜSS MicroTec AG, das der Finanzierung des Betriebsgrundstücks Sternenfels diente. Dieses Darlehen wies zum 31. Dezember 2015 noch einen Darlehensstand von 3,6 Mio. € auf und wurde im Juni 2016 komplett zurückgeführt.

Neben liquiden Mitteln in Höhe von 36,5 Mio. € (Vorjahr: 35,6 Mio. €) verfügt der Konzern zum Ende des Berichtsjahres über inländische Aval- und Kreditlinien von 8,25 Mio. € (Vorjahr: 5,25 Mio. €). Davon waren Avallinien von 3,0 Mio. € befristet bis zum 31. Dezember 2017. Die Linien wurden im Berichtsjahr ausschließlich in Form von Avalen in Anspruch genommen. Der wesentliche Teil davon entfällt auf Anzahlungsbürgschaften. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme 3,4 Mio. €.

Der Konzern verfügt insgesamt über genügend finanziellen Spielraum, notwendige Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im Wesentlichen die Betriebsgrundstücke in Garching und in Sternenfels die langfristigen Vermögenswerte.

Der Geschäfts- oder Firmenwert beträgt 15,6 Mio. € (Vorjahr: 15,8 Mio. €). Ein Teil des Goodwills (2,4 Mio. USD) wird in US-Dollar geführt und unterliegt daher Währungsschwankungen. Der gesamte Geschäfts- oder Firmenwert ist dem Segment Lithografie zugeordnet.

Die aktivierten Entwicklungskosten weisen zum 31. Dezember 2017 einen Buchwert von 0,1 Mio. € (Vorjahr: 0,2 Mio. €) auf,

der komplett dem Segment Lithografie zuzuordnen ist. Sie spielen für die Vermögenslage des Konzerns nur noch eine untergeordnete Rolle.

Darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögenswerte Lizenzen und Patente sowie das bei der SÜSS MicroTec SE aktivierte SAP-System, deren Buchwerte sich auf 1,9 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €) summieren. Sie entfallen in Höhe von 0,9 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) auf die Segmente Lithografie, Bonder und Fotomasken-Equipment sowie in Höhe von 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) auf das Segment Sonstige. Unter den immateriellen Vermögenswerten ist außerdem die im Rahmen der Photonic-Systems-Akquisition erworbene Technologie ausgewiesen, die zum Stichtag einen Restbuchwert von 0,6 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €) aufwies und dem Segment Lithografie zugeordnet ist. Die Technologie dotiert in US-Dollar und wird planmäßig über acht Jahre abgeschrieben.

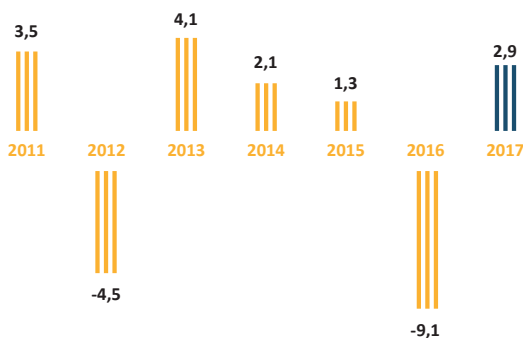
Den größten Anteil am konzernweiten Sachanlagevermögen haben die beiden Betriebsgrundstücke in Garching und Sternenfels, die zum Jahresende einen Restbuchwert von 15,1 Mio. € (Vorjahr: 13,9 Mio. €) aufwiesen. Dort sind die SÜSS MicroTec Lithography GmbH, die SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG sowie die SÜSS MicroTec SE ansässig.

Das übrige Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist.

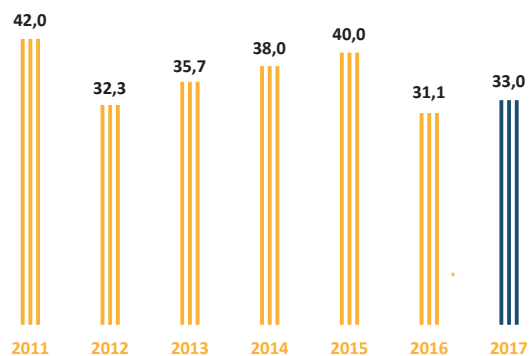
Der Buchwert des Sachanlagevermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Die latenten Steueransprüche betragen zum Stichtag 0,7 Mio. € nach 2,2 Mio. € im Vorjahr. Sie reduzierten sich im Wesentlichen durch die Veränderung der aktiven latenten Steuern auf Unterschiede in der Vorratsbewertung und der immateriellen Vermögenswerte. Zum 31. Dezember 2017 bestanden für die deutschen Gesellschaften keine steuerlichen Verlustvorträge. Die Tochtergesellschaft in Frankreich hat in 2017 die noch vorhandenen Verlustvorträge komplett genutzt. Für die Tochtergesellschaft in Korea wurden – unter Berücksichtigung der aktuellen Konzernplanung für 2017 – aktive latente Steuern auf Verlustvorträge in

FREE CASHFLOW in Mio.€



NETTOLIQUIDITÄT in Mio. €



geringem Umfang angesetzt. Für die Verlustvorträge der US-Gesellschaften und der Tochtergesellschaft in Japan wurden hingegen – wie in den Vorjahren – keine aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge angesetzt.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind im Berichtsjahr um 22,4 Mio. € auf 159,2 Mio. € angestiegen. Der Anstieg ist hauptsächlich auf den stark gestiegenen Bestand an Vorratsvermögen zum Jahresende zurückzuführen. Zudem hat sich der Bestand an liquiden Mitteln leicht erhöht.

Die Vorräte erhöhten sich von 73,8 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 97,9 Mio. € zum Jahresende. Die Erhöhung ist zum Teil auf den um rund 12,0 Mio. € angewachsenen Bestand an fertigen Maschinen zurückzuführen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, bei denen jedoch die Endabnahme (und damit die Umsatzlegung) noch aussteht. Auch die Bestände an unfertigen Erzeugnissen sowie an Materialien und Hilfsstoffen haben sich um 4,0 Mio. € bzw. 6,9 Mio. € erhöht. Außerdem ist der Bestand an Demonstrationsgeräten um 1,8 Mio. € gestiegen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sanken im Vergleich zum Vorjahr von 24,1 Mio. € auf 19,6 Mio. €. Der Rückgang ist im Wesentlichen stichtagsbedingt.

Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich von 35,6 Mio. € auf 36,5 Mio. €.

Der Anstieg der sonstigen Vermögenswerte von 2,8 Mio. € im Vorjahr auf 4,6 Mio. € zum Jahresende ist im Wesentlichen auf höhere Umsatzsteuerforderungen zurückzuführen, die sich stichtagsbedingt ergeben haben.

Die langfristigen Schulden reduzierten sich von 8,3 Mio. € auf 7,2 Mio. €. Unter den langfristigen Schulden werden zum einen die Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen, die sich im Geschäftsjahr auf 2,5 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €) beliefen. Zum anderen sind hier die Pensionsverpflichtungen des SÜSS MicroTec Konzerns enthalten, für die zum Jahresende ein Betrag von 4,7 Mio. € (Vorjahr: 4,8 Mio. €) passiviert war. Der Rückgang der Finanzverbindlichkeiten resultiert aus der planmäßigen Tilgung des Darlehens für die Grundstücksfinanzierung Garching, die sich insgesamt auf 1,0 Mio. € belief.

Bei den kurzfristigen Schulden war ein deutlicher Anstieg von 46,9 Mio. € im Vorjahr auf 67,7 Mio. € zum Bilanzstichtag zu verzeichnen. Die hier enthaltenen Kundenanzahlungen sind deutlich angestiegen und beliefen sich zum Geschäftsjahresende auf 40,3 Mio. € (Vorjahr: 22,6 Mio. €). Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen war stichtagsbedingt ein Anstieg von 3,4 Mio. € im Vorjahr auf 7,3 Mio. € zu verzeichnen. Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten erhöhten sich aufgrund höherer Verbindlichkeiten für Prämien und Provisionen von 5,4 Mio. € auf 6,7 Mio. €. Die Rückstellungen sind hingegen von 5,2 Mio. € auf 2,7 Mio. € gesunken. In den hohen Rückstellungen des Vorjahres waren insgesamt rund 2 Mio. € für die Neuausrichtung des Vertriebs in Japan und für die Abfindung eines Vorstandsmitglieds enthalten. Beide Verpflichtungen bestanden zum Jahresende 2017 nicht mehr.

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns hat sich seit dem 31. Dezember 2016 um 2,6 Mio. € auf 127,0 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote sank im Jahresvergleich von 69,2 Prozent auf 62,9 Prozent.

INVESTITIONEN

Gezielte Investitionen stärken das Unternehmen

Die SÜSS MicroTec SE ist Eigentümerin der Betriebsgrundstücke in Garching und Sternenfels, an denen der Firmensitz sowie die Betriebe der SÜSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG ihren Sitz haben. Die SÜSS MicroTec SE investiert laufend in die Betriebsgebäude an den beiden Standorten, um sie auf dem neuesten technischen Stand zu halten.

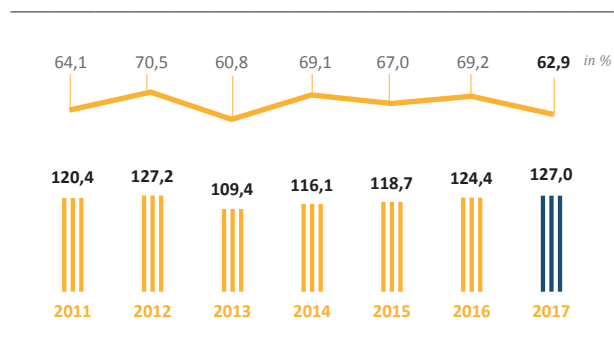
Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in technische Anlagen und Maschinen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Diese Tätigkeiten erfordern keine investitionsintensiven Anlagen und Maschinen.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von etwa 2 Prozent des Umsatzes bewegen werden. Eine Ausnahme stellt nur die in dem Segment Sonstige enthaltene Produktlinie Mikrooptik dar. In dieser Produktlinie wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind.

Für Entwicklungsleistungen, die nach IFRS die Voraussetzungen zur Aktivierung erfüllen, werden immaterielle Vermögenswerte erfasst. Ein Teil der Investitionen ist daher dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen.

Die SÜSS MicroTec SE ist Eigentümerin des konzernweiten SAP-Systems, das sowohl von den deutschen Gesellschaften als auch von den US-Gesellschaften SÜSS MicroTec, Inc., Corona, USA, und SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA, sowie von der SÜSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsinchu, Taiwan, genutzt wird.

EIGENKAPITAL in Mio. € **UND EIGENKAPITALQUOTE** in %



MITARBEITER

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Unser Geschäft ist geprägt von Internationalität, globaler Ausrichtung und kultureller Vielfalt. Über den Globus verteilt haben wir Mitarbeiter in Entwicklung, Produktion, Verwaltung, Vertrieb und Service, welche ein wichtiges Netzwerk für den standortübergreifenden Wissensaustausch und die interkulturelle Zusammenarbeit bilden. Wir arbeiten in flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und ermöglichen unseren Mitarbeitern, sich einzubringen und sich entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen weiterzuentwickeln. Die Motivation, das Wissen und die Flexibilität unserer Mitarbeiter sind wichtige Voraussetzungen für den langfristigen Unternehmenserfolg.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2017 waren 779 (Vorjahr: 711) Mitarbeiter im Konzern beschäftigt. Im gesamten Unternehmen waren zum 31. Dezember 2017 34 Auszubildende in kaufmännischen und technischen Bereichen beschäftigt (2016: 30). Seit jeher arbeitet das Unternehmen eng mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen, auch um den Namen und die Bedeutung von SÜSS MicroTec möglichst früh an talentierte Absolventen heranzutragen und den Nachwuchs für das erfolgreiche Bestehen des Unternehmens zu sichern.

Seit dem Geschäftsjahr 2017 sind börsennotierte Unternehmen verpflichtet, eine nichtfinanzielle Erklärung abzugeben. SÜSS MicroTec erstellt hierzu einen separaten nichtfinanziellen Bericht, in dem die Sachverhalte für das Unternehmen dargestellt werden. Dieser Bericht wird zusammen mit dem Lagebericht beim Bundesanzeiger offengelegt sowie ergänzend im Geschäftsbericht sowie der Unternehmenswebsite veröffentlicht. In dem Bericht stellt SÜSS MicroTec die Belange der Mitarbeiter sowie die Ziele und Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele dar.

Durch das im Mai 2015 in Kraft getretene Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (§ 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 des AktG) sind bestimmte Gesellschaften

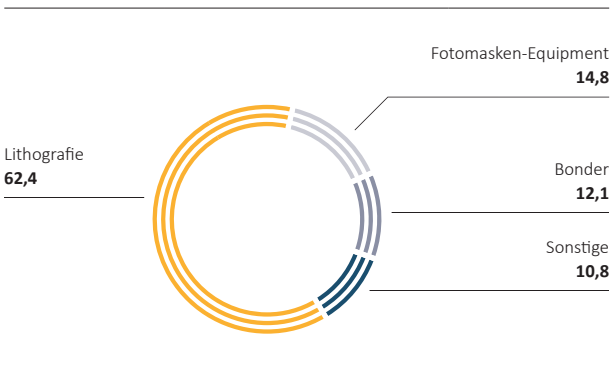
verpflichtet, erstmals Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat sowie Vorstand und den nachfolgenden zwei Führungsebenen festzulegen. Darüber hinaus muss festgelegt werden, bis wann der jeweilige Frauenanteil erreicht werden soll.

Für die deutschen Gruppengesellschaften beschloss der Vorstand der damaligen SÜSS MicroTec AG am 2. September 2015, dass für die erste und zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands jeweils eine Zielgröße für den Frauenanteil von 20 Prozent angestrebt wird, und legte eine Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017 fest. Zum 30. Juni 2017 wurde die Zielfestlegung auf der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands übererfüllt, da der Frauenanteil zu diesem Zeitpunkt 27,3 Prozent betrug und sich damit gegenüber einem Frauenanteil zum Zeitpunkt der Beschlussfassung am 2. September 2015 von 18 Prozent deutlich erhöhte. Auch der Frauenanteil auf der zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands hat sich im Zeitraum vom 2. September 2015 bis zum 30. Juni 2017 von 14 Prozent auf 19,2 Prozent erhöht, wengleich das gesetzte Ziel auf dieser zweiten Führungsebene von 20 Prozent nicht ganz erreicht werden konnte. Für die nur sehr geringe Abweichung von der Zielgröße auf der zweiten Führungsebene bestehen keine spezifischen Gründe.

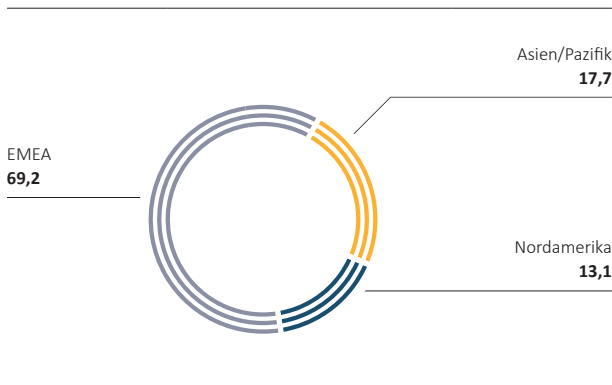
Zum Ablauf der ersten Umsetzungsfrist beschloss der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG am 30. Juni 2017 für den Frauenanteil im Aufsichtsrat eine Zielgröße von 25 Prozent bei einer Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2022. Für den Frauenanteil im Vorstand der SÜSS MicroTec AG beschloss der Aufsichtsrat eine Zielgröße von null Prozent, ebenso bei einer Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2022.

Auch zum 31. Dezember 2017 wurde die Zielfestlegung auf der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands übererfüllt, da der Frauenanteil zu diesem Zeitpunkt 30,0 Prozent betrug. Auch der Frauenanteil auf der zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands hat sich im Zeitraum zum 31. Dezember 2017 auf 22,2 Prozent erhöht und liegt damit oberhalb der Zielquote. Zum 31. Dezember 2017 betrug der Frauenanteil im Aufsichtsrat 25 Prozent und im Vorstand null Prozent. Diese Beschlussfassungen gelten nach der Umwandlung unverändert auch für die SÜSS MicroTec SE fort.

MITARBEITER NACH SEGMENTEN 2017 in %



MITARBEITER NACH REGIONEN 2017 in %

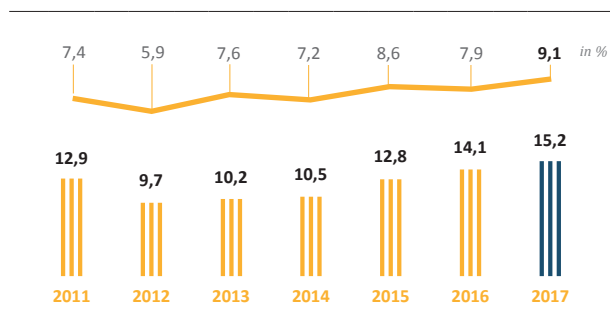


FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben erhöhten sich erneut von 14,1 Mio. € im Vorjahr auf 15,2 Mio. €, was im Geschäftsjahr 2017 in Relation zum Umsatz einer Aufwandsquote von 9,1 Prozent (Vorjahr: 8,0 Prozent) entspricht. Sie betrafen mit 10,0 Mio. € (Vorjahr: 8,7 Mio. €) das Segment Lithografie und mit 2,8 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €) das Segment Bonder. 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €) waren dem Segment Fotomasken-Equipment zuzuordnen. Das Segment Sonstige verbuchte 2017 einen Aufwand von rund 1 Mio. €.

Ende 2017 waren 160 Mitarbeiter – und damit fast jeder fünfte Mitarbeiter von SÜSS MicroTec – im Bereich Forschung und Entwicklung tätig (Vorjahr: 153 Mitarbeiter).

FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGS-AUFWAND (F&E) in Mio. € UND F&E-QUOTE in % vom Umsatz



Lithografie

Das größte Segment vereinigt die Produktlinien Mask-Aligner, UV-Projektionsgeräte, Laser-Processing sowie Belacker und Entwickler.

Mask-Aligner – In der Produktlinie Mask-Aligner – eine unserer Kernproduktlinien – werden kontinuierlich Optimierungen an den Maschinen und Prozessabläufen durchgeführt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die erste Installation der 4. Generation der MA/BA 6/8 in sehr kurzer Zeit abgeschlossen werden. Im Verlauf des Geschäftsjahres wurden weitere Geräte bei Kunden erfolgreich installiert und abgenommen. Mittels gelebter agiler Softwareentwicklung, Anforderungsmanagement und mit dem Einsatz moderner Test-Tools sowie einem starken Fokus auf Qualität ist es gelungen, eine völlig neue Softwareplattform zu schaffen. Unsere Kunden schätzen vor allem die einfache Bedienung, die kurzen Installationszeiten und den reibungslosen Betrieb. Die MA/BA Gen4 kann bei Bedarf nun auch mit dem neuartigen LED-Lampenhaus für Mask-Aligner ausgestattet werden. Als erster Hersteller auf dem Markt bietet SÜSS MicroTec bereits seit April 2016 einen halbautomatischen Mask-Aligner mit umweltfreundlichem UV-LED-Lampenhaus an. Die zukunftsfähigen UV-LEDs bieten eine höchst energieeffiziente und wartungsfreie Lichtquelle mit einer extrem langen Lebensdauer. Die LEDs müssen nur während der tatsächlichen Belichtung eingeschaltet werden, so dass ein stromfressender Dauerbetrieb der UV-Lampe vermieden werden kann.

Zusätzlich zu den insgesamt guten Umsätzen im Lithografie-Business war 2017 geprägt durch die erfolgreiche Auslieferung eines Großauftrags für Mask-Aligner mit Optionen zum WLO-Imprint (Wafer-Level-Optic-Imprint) und UV-Stacking (UV-Bond-Montage von WLO-Substraten). Dafür wurden neben der Chuck- und Applikationsentwicklung für den Kunden zahlreiche Softwareanpassungen vorgenommen, um die Handhabung von manuellen Geräten in der Volumenproduktion zu vereinfachen.

Zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen im Kundenmaterial und damit zur Verringerung der Ausschussquote wurde bereits im Geschäftsjahr 2016 begonnen, sogenannte ESD („Electrostatic Discharge“)-Handling-Lösungen für die automatischen Mask-Aligner zu entwickeln. Die von SÜSS MicroTec angebotenen ESD-Lösungen sind für Neumaschinen und als Upgrade für bestehende Maschinen verfügbar. Im Geschäftsjahr 2017 lag der Fokus auf der Weiterentwicklung dieser Technologie für unsere automatischen Maschinen, insbesondere für die MA200.

UV-Projektionsscanner – Diese Produktlinie wird am Standort Corona, USA, gefertigt. Schwerpunkt der F&E-Arbeiten ist die Entwicklung einer neuen Plattform des Projektionsscanners DSC300 Gen3. Kern der Neuerungen ist eine optische Vergrößerung bzw. Verkleinerung des Projektionsbildes, um die besonders im Fan-out-Wafer-Level-Packaging-Prozess auftretenden Verschiebungen der Chips kompensieren zu können. Durch zusätzliche Verwendung einer neuartigen Waferstage erreicht die DSC300 Gen3 ein Overlay im Sub-µm-Bereich und zieht damit mit Steppern gleich. Weitere Neuerungen sind eine verbesserte Auflösung durch Einsatz einer größeren numerischen Apertur, höhere Prozessstabilität durch Regelung der Fokustiefe sowie die optionale Verfügbarkeit von Infrarot-Alignment. Die neue DSC300 Gen3 bietet einen um rund 40 Prozent gesteigerten Durchsatz und ist mit über 80 Wafern pro Stunde das mit Abstand schnellste vollautomatische Belichtungssystem in seiner Klasse bei gleichzeitig günstigen Kosten. Die Markteinführung der DSC300 Gen3 wird im Laufe des Jahres 2018 erfolgen.

Excimer-Laser-Ablationssysteme – Diese ebenfalls in Corona, USA, produzierten Geräte ermöglichen die direkte Strukturierung von feinen Aufbau- und Verbindungslinien, wobei kostengünstigere nichtfotosensitive Materialien verwendet werden können und die Anzahl der Bearbeitungsschritte um bis zu 50 Prozent reduziert wird. Neben mehreren Kooperationen mit Forschungsinstituten zum Langzeit- und Stresstest derart hergestellter Strukturen sowie Kooperationen mit Materialherstellern zur Entwicklung spezieller Materialien zur Laser-Ablation wurde ein neuartiger 300-W-Produktionslaser qualifiziert, der die Kosten des Geräts und damit die Kosten der erzeugten Strukturen signifikant senkt. In einem zweiten Entwicklungsschritt sollen zwei dieser neuartigen Excimer-Laser parallel betrieben werden, was zu einer signifikanten Durchsatzerhöhung führen wird.

Belacker und Entwickler – Im Segment der Belacker- und Entwickleranlagen lag der Fokus auf der Qualifizierung der neuen ACS300-Gen3-Plattform für Cu-Pillar und FOWLP (Fan-out-Wafer-Level-Packaging) Anwendungen bei wichtigen Foundry- und OSAT (Outsourced Assembly and Test)-Unternehmen in Asien.

Darüber hinaus wurde für den Schlüsselbereich Dispenssysteme das SÜSS eigene Pumpensystem für Fotolacke und Klebersysteme zum temporären Bonden weiterentwickelt und plattformübergreifend qualifiziert. Für dieses Pumpensystem wurde eine bedienerfreundliche, intelligente Steuerungssoftware entwickelt, die eine automatische Kalibrierung ermöglicht und damit die Einrichtung erheblich vereinfacht. Ein selbstlernender Algorithmus sorgt dafür, dass Dispensraten und -volumina automatisch überwacht und nachjustiert werden, um eine bestmögliche Langzeitstabilität zu erreichen.

Für den MEMS-Bereich wurde ein neues Sprühbelackermodul für die ACS200-Gen3-Maschinenplattform entwickelt, das eine Durchsatzsteigerung von bis zu 50 Prozent bei gleichzeitiger Verbesserung der Schichtqualität ermöglicht.

Bonder

Dieses Segment untergliedert sich in die beiden Teilbereiche temporäres und permanentes Bonden.

Im Bereich temporäres Bonden wurde auf Basis der bestehenden XBC300-Gen2-Plattform ein neuer Laserdebonder mit integrierten Modulen zum Abheben der Trägerwafer und zum Entfernen von Kleberrückständen mittels Klebefolie entwickelt. Das neue Verfahren wird in der 3D-TSV-Technologie und verwandten Bereichen zum Einsatz kommen. Parallel zur Maschinenentwicklung wurden in Kooperation mit führenden Materialherstellern entsprechende Klebersysteme für das neue Verfahren qualifiziert.

Der Schwerpunkt der Entwicklungstätigkeiten im Bereich permanentes Bonden lag auf der Weiterentwicklung der neuen automatisierten XBS200-Plattform für permanente Bondverfahren bei MEMS-, RF- und LED-Anwendungen. Die XBS200-Plattform wurde im März 2017 in einer ersten Konfiguration für Thermokompressions-Bondprozesse in den Markt eingeführt. Neben einer neuartigen Transportvorrichtung zur Übergabe justierter Wafer vom Bond-Aligner-Modul in die eigentliche Bondkammer wurde ein innovatives Laser-Pre-Bond-Verfahren für die XBS200 entwickelt, mit dem die Wafer nach der Justage im Bond-Aligner-Modul vorfixiert werden können. Daraus ergibt sich eine Verbesserung der Post-Bond Justage nach dem Thermokompressions-Bondprozess, wodurch sich mehr Sensoren auf dem Wafer unterbringen lassen. Dieses neue Verfahren findet sowohl bei reinen Glas-Silizium-Verbindungen als auch bei Silizium-Silizium-Verbindungen mit Metallzwischen-schichten Anwendung, welche typischerweise für MEMS-Sensoren im Automobil- und Consumerbereich eingesetzt werden. In der zweiten Jahreshälfte wurde die Entwicklung weiterer Prozessmodule für die XBS200 gestartet, um den Einsatzbereich der Plattform auf Direktbondverfahren zu erweitern.

Auch im Geschäftsjahr 2017 wurde wie in den vorhergehenden Jahren die langjährige und erfolgreiche Entwicklungspartnerschaft mit dem Forschungsinstitut imec in Belgien fortgeführt. In diesem Rahmen wurden sowohl Direktbondverfahren für MEMS- und CIS (CMOS-Image-Sensor)-Anwendungen als auch temporäre Bondprozesse für FOWLP (Fan-out-Wafer-Level-Packaging)-Anwendungen weiterentwickelt.

Fotomasken-Reinigung

EUVL („Extreme Ultraviolet Lithography“) erweist sich zwischenzeitlich als wegweisende und notwendige Technologie für den 7/5-nm-HP („Half Pitch“)-Technologieknoten. Daher wurden im Segment Fotomasken-Equipment verschiedene Projekte im Bereich R&D weiter intensiv vorangetrieben. Ein kritischer Faktor ist der Einsatz eines EUVL-Pellicle (Schutzschicht), welches, wie bei der heute meistverbreiteten 193i-Lithografie, die aktive Seite der Fotomaske vor Partikeln und Defekten schützt und so späteren Abbildungsfehlern auf dem Wafer vorbeugt. Aufgrund der intrinsischen Eigenschaften dieses EUVL-kompatiblen Pellicle müssen bei der wiederkehrenden Rückseitenreinigung von EUV-Masken, bei der das Pellicle möglichst auf der Vorderseite der Maske verbleibt, entsprechende Maßnahmen getroffen werden, damit das Pellicle während des Handlings oder der Reinigung unversehrt bleibt. Im Rahmen des europäischen Verbundprojekts SeNaTe („Seven Nanometer Technology“) entwickelte SÜSS MicroTec für seine Maskenreinigungsanlage MaskTrack PRO in Form eines ersten Prototyps eine spezielle Halterung, die es ermöglicht, dass das Pellicle während des Rückseitenreinigungsprozesses auf der Fotomaske verbleibt, aber dennoch weder beschädigt noch kontaminiert wird. Zur Jahresmitte von 2017 wurde dann erstmalig diese Funktionalität bei einer Kundenanlage MaskTrack X in den USA, die speziell für EUVL ausgelegt ist, integriert. Die Technologie befindet sich seit Ende des Jahres nun in der Evaluierungsphase. Die entsprechenden ersten Ergebnisse bzgl. des Einflusses auf der Rückseitenreinigung auf die Vorderseite werden zum Ende des ersten Quartals 2018 erwartet.

Darüber hinaus wurde erstmalig das MaskTrack-X-Gluebuster-System, ebenfalls in den USA zur Evaluierung installiert, und an eine MaskTrack-X-Anlage angebunden. Dieses System dient zur schwefelsäurefreien und lokalen Abreinigung von Kleberesten, die bei der Demontage von Pellicles auf der Vorderseite der Fotomaske verbleiben. Hierdurch wird insgesamt eine Unversehrtheit bzw. eine Verlängerung des Lebenszyklus der Fotomaske erreicht. Seit dem dritten Quartal befindet sich dieses System in der Qualifizierung, welche ebenfalls bis März 2018 abgeschlossen werden soll. Basierend auf den dort bereits gewonnenen Erkenntnissen wurde inzwischen die Optimierung zur Fertigstellung eines Serientyps, dessen Freigabe dann unmittelbar im Anschluss geplant ist, gestartet.

Sowohl für die optische Lithographie als auch für EUVL wurde die Entwicklung TranSonic-Technologie abgeschlossen. Hierbei handelt es sich um eine Methode zur Einbringung akustischer Energie über die Rückseite der Maske während der Vorderseitenreinigung. Dies ermöglicht insbesondere die Abreinigung kleinster Partikel < 20nm aus extrem feinen Strukturen, ohne diese zu beschädigen. Zudem dient TranSonic für die gleichzeitige Rückseitenreinigung, insbesondere auch bei EUV-Masken, was eine Verkürzung der Prozesszeiten zur Folge hat und damit einen höheren Durchsatz in der Anlage bedeutet.

Im Bereich der Develop-Prozessentwicklung wurde die Dual-Curtain-ASONIC-Technologie als neueste Generation von Düsen für nasschemische Entwicklungsprozesse bei der Fotomaschinenherstellung fertiggestellt. Mit dieser neuen Düse wird ein erhöhter Austausch vom Entwicklungsmedium auf der Maskenoberfläche und damit eine Kompensation des Pattern-Loading-Effektes erzielt. Auch die Erweiterung der Transducer-Anzahl führt zu einem homogeneren Ergebnis beim Entwicklungsprozess.

Für die Nano-Imprint-Technologie wurde im Jahr 2017 die erste Version eines integrativen Moduls zur Reinigung von Mesa-Strukturen auf NIL-Templates entwickelt. Dies wird zukünftig Bestandteil einer lithografischen Imprint-Anlage eines externen Herstellers sein. Die Evaluierung ist bis Ende des ersten Halbjahres 2018 vorgesehen.

DIE HOLDING – SÜSS MICROTEC SE

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie bestimmt in Abstimmung mit den operativen Einheiten die strategische Ausrichtung. Ebenso ist die Holding für Investor-Relations, das konzernweite Finanzwesen und Marketing verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften.

Die SÜSS MicroTec SE ist in der Regel alleinige Anteilseignerin an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Unternehmen innerhalb der Unternehmensgruppe. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Vermietung der Gebäude an den Standorten Garching und Sternenfels an Tochtergesellschaften, durch Zinserträge aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen sowie durch bestehende Ergebnisabführungsverträge.

DARSTELLUNG DER FINANZIELLEN KENNZAHLEN DER HOLDING

in Tsd. €	SÜSS MicroTec SE (HGB)			
	2017	2016	Änderung	in %
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.712	-9.500	12.212	-
Eigenkapital	80.861	78.148	2.713	3
Bilanzsumme	115.254	124.834	-9.580	-8
EK-Quote in %	70	63		
Anlagevermögen	70.298	67.574	2.724	4
% der Bilanzsumme	61	54		
Umlaufvermögen inkl. ARAP	44.956	57.260	-12.304	-21
% der Bilanzsumme	39	46		

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die immateriellen Vermögensgegenstände belaufen sich zum Stichtag auf 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €).

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zum Bilanzstichtag mit 47,5 Mio. € (Vorjahr: 47,5 Mio. €) bilanziert.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden bei der SÜSS MicroTec, Inc., Corona, USA, Kapitalerhöhungen in Höhe von 7,6 Mio. € durchgeführt. Gegenläufig wirkt sich eine außerplanmäßige Abschreibung auf den Wertansatz dieser Beteiligung von rund 7,6 Mio. € aus.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen erhöhten sich um rund 1,9 Mio. € auf einen Buchwert von 6,3 Mio. €. An die SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA, wurden im Geschäftsjahr durch die SÜSS MicroTec SE keine weiteren Darlehensbeträge ausgereicht. Die SÜSS MicroTec SE erklärte im Zuge einer Kapitalrestrukturierung auf bereits in Vorjahren voll wertberichtigte Darlehensforderungen einen Darlehensverzicht in Höhe von 15 Mio. USD (12,5 Mio. €). Zum 31. Dezember 2017 belief sich das Darlehen auf nominal 14,5 Mio. USD (Vorjahr: 29,5 Mio. USD) und weist einen Buchwert von 2,8 Mio. € auf.

Das an die SÜSS MicroTec KK, Yokohama, Japan, gewährte Darlehen von 775 Mio. JPY (Vorjahr: 775 Mio. JPY) weist zum 31.12.2017 einen Buchwert von 1,1 Mio. € auf.

Ein im Geschäftsjahr an die SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsinchu, Taiwan, ausgereichtes Darlehen von nominal 85 Mio. TWD weist zum 31.12.2017 einen Buchwert von 2,4 Mio. € auf.

Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen sanken um 18,7 Mio. € auf 14,7 Mio. €. Der Anstieg ist im Wesentlichen stichtagsbedingt. In diesem Betrag sind die Forderungen aus den Ergebnisabführungen der SUSS MicroTec Lithography GmbH und der SUSS MicroTec REMAN GmbH sowie der phasengleichen Gewinnvereinnahmung der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG enthalten.

Im Geschäftsjahr erhöhte sich die Liquiditätsposition der SÜSS MicroTec SE um 4,8 Mio. € auf 27,3 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sanken im Geschäftsjahr um 10,7 Mio. € auf 26,1 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken im Verlauf des Jahres 2017 um 1,0 Mio. €. Der Rückgang resultiert aus den geleisteten planmäßigen Tilgungen in Höhe von 1,0 Mio. € für ein Bankdarlehen, das der Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Garching dient.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses erhöhte sich das Eigenkapital der Gesellschaft von 78,1 Mio. € auf 80,9 Mio. €.

WESENTLICHE EREIGNISSE MIT EINFLUSS AUF DIE ERTRAGSLAGE DER HOLDING

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec SE ergab sich für das Geschäftsjahr 2017 ein Jahresüberschuss von 2,7 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 9,5 Mio. €).

Die Umsatzerlöse der Holding beliefen sich auf 9,0 Mio. € (Vorjahr: 9,3 Mio. €) und umfassten im Wesentlichen die den Tochtergesellschaften in Rechnung gestellten Umlagen für Managementleistungen, Marketing und Versicherungen. Darüber hinaus waren in den Umsatzerlösen auch Weiterbelastungen für das konzernweite SAP-System, Mieterlöse und Lizenzgebühren enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Fremdwährungsgewinne in Höhe von 1,8 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten – neben laufenden Aufwendungen für die Verwaltung – Fremdwährungsverluste in Höhe von 1,6 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €).

Auf Grund des zum 1. Januar 2011 gültigen Ergebnisabführungsvertrags mit der SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 9,1 Mio. € (Vorjahr: 11,7 Mio. €) ertragswirksam erfasst. Aufgrund des im Geschäftsjahr 2008 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrags mit der SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 0,7 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) erfasst. Weiterhin wurden aus der phasengleichen Ergebnisvereinnahmung der

SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG Beteiligungserträge von 2,5 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €) gebucht. Darüber hinaus hat die Holding aus Dividendenausüttungen der SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsinchu, Taiwan, Beteiligungserträge von rund 1,7 Mio. € erzielt.

Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens umfassten die Zinserträge für die langfristigen Darlehen, die an die Tochtergesellschaften SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA, und SUSS MicroTec KK, Yokohama, Japan, gewährt wurden.

Auf die Finanzanlagen wurden Abwertungen in Höhe von 8,2 Mio. € (Vorjahr: 22,8 Mio. €) vorgenommen. Davon entfielen 7,6 Mio. € auf die Beteiligung an der SUSS MicroTec, Inc., Corona, USA. 0,1 Mio. € bzw. 0,5 Mio. € betrafen Abwertungen aufgrund veränderter Wechselkurse auf langfristige, in Fremdwährung notierte Darlehen, die der SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Taiwan, bzw. der SUSS MicroTec KK, Yokohama, Japan, gewährt wurden.

Die Zinsaufwendungen sanken im Geschäftsjahr um 0,1 Mio. €, was im Wesentlichen auf die im Vorjahr vorzeitige vollständige Tilgung des Bankdarlehens zur Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels zurückzuführen ist.

In der SÜSS MicroTec SE waren im Geschäftsjahr 2017 durchschnittlich 20 (Vorjahr: 19) Mitarbeiter tätig.

Die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec SE hängt vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung und Abführung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft. Zudem ist das Ergebnis beeinflusst von Fremdwährungseffekten, die sich im Wesentlichen aus der Veränderung der Wechselkurse von USD, JPY und CHF zum Euro ergeben. Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die SÜSS MicroTec SE vor dem Bewertungsergebnis aus Finanzanlagen ein Ergebnis auf Vorjahresniveau.

ÜBERNAHMERECHTLICHE ANGABEN GEMÄSS § 289A HGB UND § 315A HGB

1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Zum 31. Dezember 2017 belief sich das gezeichnete Kapital des Unternehmens auf 19.115.538,00 € (Vorjahr: 19.115.538,00 €). Das Grundkapital ist in 19.115.538 (Vorjahr: 19.115.538) auf Namen lautende, nennwertlose Stückaktien unterteilt, auf die ein anteiliger Betrag von 1,00 € je Aktie entfällt. Die Aktien sind voll eingezahlt.

Mit allen Aktien sind die gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme und ist maßgebend für den Anteil der Aktionäre am Gewinn der Gesellschaft. Die Rechte und Pflichten der Aktionäre ergeben sich im Einzelnen aus den Regelungen des AktG, insbesondere aus den §§ 12, 53a ff., 118 ff. und 186 AktG.

Gemäß § 67 Abs. 2 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Die Aktionäre haben der Gesellschaft die zur Führung des Aktienregisters erforderlichen Daten zu übermitteln.

2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, bestehen nach der Satzung nicht. Wir haben auch keine Kenntnis von dem Bestehen derartiger Vereinbarungen zwischen Aktionären.

3. Beteiligungen am Kapital, die 10 Prozent der Stimmrechte überschreiten

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, die 10 Prozent der Stimmrechte erreichen oder überschreiten, sind uns nicht gemeldet worden und auch nicht bekannt.

4. Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.

5. Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben

Soweit die SÜSS MicroTec SE im Rahmen eines Mitarbeiteraktienprogramms Aktien an Mitarbeiter ausgibt, werden die Aktien den Mitarbeitern unmittelbar übertragen. Die begünstigten Mitarbeiter können die ihnen aus den Mitarbeiteraktien zustehenden Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Satzung ausüben. Derzeit gibt es kein Aktienprogramm für Mitarbeiter.

6. Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und die Änderung der Satzung

Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind in den §§ 84 und 85 AktG geregelt. Danach werden Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Über die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern beschließt der Aufsichtsrat mit der einfachen Mehrheit der Stimmen.

Der Vorstand besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus mindestens zwei Personen, wobei die Zahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat bestimmt wird. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 AktG und § 7 Abs. 2 der Satzung einen Vorsitzenden bzw. Sprecher des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden bzw. Sprecher ernennen.

Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, wird das Mitglied nach § 85 AktG in dringenden Fällen auf Antrag eines Beteiligten gerichtlich bestellt. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 Abs. 3 AktG die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Eine Änderung der Satzung bedarf nach § 179 AktG eines Beschlusses der Hauptversammlung. Die Befugnis zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen, ist gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung dem Aufsichtsrat übertragen.

Satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen nach §§ 133 und 179 AktG in Verbindung mit § 26 Abs. 1 der Satzung der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und einer einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit vorschreibt.

7.

Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen

Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 18. Juni 2018 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neue auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen (Genehmigtes Kapital 2013) zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18. Juni 2018 eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 Prozent des bei der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals in Höhe von 19.115.538,00 € zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach § 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Prozent des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgeübt werden. Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe eines Verkaufsangebots erfolgen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden.

8.

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen

Mit der Deutschen Bank AG, der DZ Bank AG und der Baden-Württembergischen Bank bestehen bilaterale Kreditverhältnisse, die hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw. Konditionen Unterschiede aufweisen. So enthält ein Kreditverhältnis ein außerordentliches Kündigungsrecht, falls eine Änderung der Gesellschaftsverhältnisse/ ein Change of Control eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige Einigung über die Fortsetzung zu gegebenenfalls veränderten Konditionen, z. B. hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger Absprachen, erzielt wurde.

Sonstige wesentliche Vereinbarungen der SÜSS MicroTec SE, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

9.

Entschädigungsvereinbarung der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind

Entschädigungsvereinbarungen o. Ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung besonderer Aktiegattungen noch durch Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der SÜSS MicroTec SE können im Fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende Change-of-Control-Klauseln nicht wegfallen.

KONZERNERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG GEMÄSS § 289F UND § 315D HGB

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE haben mit Datum 8. März 2018 eine gemeinsame Konzernenerklärung zur Unternehmensführung nach §§ 289f und 315d HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.suss.com > *Investor Relations* > *Corporate Governance* allgemein zugänglich gemacht.

RELEVANTE ANGABEN ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB ist Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts. Gemäß § 317 Abs. 2 Satz 4 HGB sind die Angaben nach § 289f Abs. 2 HGB nicht in die Prüfung einzubeziehen; insoweit ist im Rahmen der Prüfung lediglich festzustellen, ob diese Angaben gemacht wurden. Die Erklärung zur Unternehmensführung beinhaltet die Entsprechenserklärung, Angaben zu Unternehmensführungspraktiken und die Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat. Wir verfolgen dabei das Ziel, die Darstellung der Unternehmensführung übersichtlich und prägnant zu halten.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG UND BERICHT- ERSTATTUNG ZUR CORPORATE GOVERNANCE

Gem. § 161 AktG sind Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten deutschen Aktiengesellschaft verpflichtet, zumindest einmal jährlich zu erklären, ob dem Deutschen Corporate Governance Kodex entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen des Kodex nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. Auf Basis intensiver Beratungen haben Vorstand und Aufsichtsrat am 9. Januar 2018 erklärt, dass den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der letzten Fassung vom 7. Februar 2017 mit den folgenden Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, vertikaler Vergütungsausgleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschüssen und Festlegung einer Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer im Aufsichtsrat – entsprochen wird.

Der Wortlaut der aktuellen Entsprechenserklärung sowie alle vorhergehenden Erklärungen zum Kodex sind auf der Website des Unternehmens unter www.suss.com > *Investor Relations* > *Corporate Governance* > *Entsprechenserklärung* veröffentlicht.

COMPLIANCE

Als international tätiges Unternehmen ist SÜSS MicroTec darauf angewiesen, durch untadeliges Verhalten das Vertrauen der Kunden und Geschäftspartner zu gewinnen und zu erhalten. Die Einhaltung von Recht, Gesetz, unternehmensinternen Richtlinien

und freiwillig eingegangenen Selbstverpflichtungen sowie deren Beachtung durch die Konzernunternehmen ist bei SÜSS MicroTec wesentliche Leitungsaufgabe.

Verhaltenskodex

Um ein einheitliches vorbildliches Handeln und Verhalten zu gewährleisten, wurde für SÜSS MicroTec ein Verhaltenskodex (Code of Conduct) entwickelt, der für alle Mitarbeiter von SÜSS MicroTec gleichermaßen Gültigkeit besitzt und der als Leitfaden dienen soll. Der Verhaltenskodex wurde zuletzt im Geschäftsjahr 2017 überarbeitet und erneut an alle Mitarbeiter von SÜSS MicroTec zwecks Anerkennung übermitteln. Der Verhaltenskodex definiert Mindeststandards und beinhaltet Hinweise für die Mitarbeiter zum Umgang mit und der Bewältigung von ethischen und rechtlichen Herausforderungen, die im Rahmen der täglichen Arbeit auftreten können. Verstöße werden im Interesse aller Mitarbeiter und von SÜSS MicroTec konsequent verfolgt und deren Ursachen beseitigt.

Compliance-Handbuch

Das gruppenweite Compliance-Programm wird darüber hinaus durch das Compliance-Handbuch, diverse Prozessregelungen sowie die für die jeweiligen Organe gültige Geschäftsordnung ergänzt. Das Compliance-Handbuch richtet sich an alle Mitarbeiter des Konzerns mit dem Ziel, ein korrektes und einheitliches Verhalten im Umgang mit vertraulichen Unternehmensdaten sicherzustellen. Insbesondere werden darin die gesetzlich geltenden Bestimmungen des Verbots der Marktmanipulation sowie die Vorgaben des Insiderrechts erläutert. Personen, die für SÜSS MicroTec tätig sind und bestimmungsgemäß Zugang zu Insiderinformationen haben, um ihre Aufgaben bei SÜSS MicroTec wahrnehmen zu können, werden gemäß den Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes in ein Insiderverzeichnis aufgenommen. Diese Personen werden über die sich daraus ergebenden rechtlichen Pflichten sowie über die Rechtsfolgen von Verstößen aufgeklärt. Den gesetzlichen Regelungen zum Verbot von Insidergeschäften wird darüber hinaus im Rahmen einer ergänzenden internen Insiderrichtlinie Rechnung getragen, die den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens für Organmitglieder und Mitarbeiter mit Zugang zum Managementinformationssystem innerhalb definierter Zeitfenster regelt. Das Compliance-Handbuch wurde 2017 sprachlich überarbeitet und wird seither an neue Mitarbeiter zwecks Anerkennung übermitteln.

BESCHREIBUNG DER ARBEITSWEISE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Die SÜSS MicroTec SE verfügt auch nach dem vollzogenen Formwechsel in eine Societas Europaea (SE) über eine zweigeteilte Führungs- und Kontrollstruktur, die von den Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wahrgenommen wird. Die Unternehmensführung der SÜSS MicroTec SE ist durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat geprägt. Beide Organe arbeiten im Interesse des Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel eng zusammen, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich jeweils eine Geschäftsordnung gegeben.

AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und bestellt die Vorstandsmitglieder. In regelmäßigen Abständen erörtert der Aufsichtsrat mit dem Vorstand die Geschäftsentwicklung und Planung sowie die Strategie und deren Umsetzung. Er behandelt die Quartals- und Halbjahresberichte und billigt den Jahresabschluss der SÜSS MicroTec SE und des Konzerns unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte und -Ergebnisse des Abschlussprüfers. Zu seinen Pflichten gehört auch die Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen und der unternehmensinternen Richtlinien durch das Unternehmen (Compliance). Bedeutende Geschäftsvorgänge – wie beispielsweise Akquisitionen, Desinvestitionen und Finanzmaßnahmen – sind an seine Zustimmung gebunden. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet dessen Sitzungen und nimmt die Belange des Gremiums nach außen wahr. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE ist nicht mitbestimmt.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE besteht gemäß Satzung aus vier Mitgliedern. Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung vom 31. Mai 2017 wurde beschlossen, die Größe des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG von drei auf vier Mitglieder zu erweitern. Wie es der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt, gehören dem Aufsichtsrat eine nach dessen Einschätzung angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder an. Insbesondere gehört mit Herrn Dr. Stefan Reineck nicht mehr als ein ehemaliges Vorstandsmitglied dem Aufsichtsrat an, womit eine unabhängige Beratung und Überwachung des Vorstands gewährleistet ist. Die Amtsperiode des Aufsichtsrats beträgt fünf Jahre. Die laufende Amtsperiode endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2022.

Entgegen den Empfehlungen des Kodex sieht der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE von der Bildung von Ausschüssen ab. Der Aufsichtsrat, der aus vier Mitgliedern besteht, ist vielmehr der Ansicht, dass die Bildung von Ausschüssen, die Zusammenarbeit und Beschlussfindung aufgrund der Anzahl von vier Aufsichtsratsmitgliedern unnötig erschweren würde.

VORSTAND

Der Vorstand der SÜSS MicroTec SE besteht derzeit aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die Führung der Geschäfte und entscheiden über Grundsatzfragen der Geschäftspolitik sowie über die Jahres- und Mehrjahresplanung. Sie entwickeln die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmen diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgen für deren Umsetzung. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftspolitik sowie alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements sowie der Compliance.

Darüber hinaus ist der Vorstand zuständig für die Aufstellung der Quartals- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens, der Jahresabschlüsse der SÜSS MicroTec SE und der Konzernabschlüsse. Der Vorstand hat ferner für die Einhaltung von Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen und unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren Beachtung durch die Mitarbeiter aller Konzernunternehmen hin (Compliance).

VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS UND DES VORSTANDS

Die SÜSS MicroTec SE entspricht den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, die Vergütung für den Vorstand und den Aufsichtsrat individualisiert offenzulegen. Die Grundbezüge der Vergütungssysteme und die Vergütungen sind im Vergütungsbericht, der Teil des zusammengefassten Lageberichts ist, dargestellt. Im Hinblick auf die vom Deutschen Corporate Governance Kodex angestrebte „vertikale Vergütungsstruktur“ erklärt SÜSS MicroTec SE insoweit vorsorglich eine Kodexabweichung, da der Aufsichtsrat der Auffassung ist, dass die Festlegung des obersten Führungskreises und der relevanten Belegschaft unter Einbeziehung der zeitlichen Entwicklung in der Praxis zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen kann.

AKTIENGESCHÄFTE DER ORGANMITGLIEDER (EIGENGESCHÄFTE VON FÜHRUNGSPERSONEN)

Personen, die bei der SÜSS MicroTec SE Führungsaufgaben wahrnehmen, und damit insbesondere die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, sind nach Artikel 19 Marktmissbrauchsverordnung (MAR) gesetzlich verpflichtet, eigene Geschäfte mit Aktien der SÜSS MicroTec SE oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten, insbesondere Derivaten, offenzulegen, soweit der Wert der von dem Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte die Summe von 5.000 Euro zum Ende des Kalenderjahres erreicht.

Alle meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte wurden entsprechend den gesetzlichen Regelungen veröffentlicht und sind auf der Website des Unternehmens frei einsehbar unter www.suss.com > *Investor Relations* > *Corporate Governance* > *Eigengeschäfte von Führungspersonen*. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats halten zum 31.12.2017 0,44 Prozent (84.720 Stimmrechte von 19.115.538 Stimmrechten) am Grundkapital der SÜSS MicroTec SE.

FESTLEGUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER TEILHABE VON FRAUEN AN FÜHRUNGSPPOSITIONEN NACH § 76 ABS. 4 UND § 111 ABS. 5 DES AKTIENGESETZES

Durch das am 1. Mai 2015 in Kraft getretene „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ (§ 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 des AktG) sind börsennotierte Gesellschaften wie die SÜSS MicroTec SE unter anderem verpflichtet worden, Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat, Vorstand und den nachfolgenden zwei Führungsebenen festzulegen. Darüber hinaus ist dabei festzulegen, bis wann die jeweilige Zielgröße erreicht werden soll.

In Umsetzung der vorgenannten Verpflichtung beschloss der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG am 7. September 2015 sowohl für den Frauenanteil im Aufsichtsrat als auch für den Frauenanteil im Vorstand der SÜSS MicroTec SE eine Zielgröße von jeweils null Prozent. Der Frauenanteil im Vorstand blieb bis zum 30. Juni 2017 mit null Prozent unverändert und entspricht damit der Ziel festlegung. Durch die Wahl von Frau Dr. Myriam Jahn zum Mitglied des Aufsichtsrats bei der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 erhöhte sich dagegen der Frauenanteil im Aufsichtsrat auf 25 Prozent gegenüber einer Zielgröße von null Prozent.

Für die deutschen Gruppengesellschaften beschloss der Vorstand der SÜSS MicroTec AG am 2. September 2015, dass für die erste und zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands jeweils eine Zielgröße für den Frauenanteil von 20 Prozent angestrebt wird, und legte eine Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017 fest. Zum 30. Juni 2017 wurde die Zielfestlegung auf der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands übererfüllt, da der Frauenanteil zu diesem Zeitpunkt 27,3 Prozent betrug und sich damit gegenüber einem Frauenanteil zum Zeitpunkt der Beschlussfassung am 2. September 2015 von 18 Prozent deutlich erhöhte. Auch der Frauenanteil auf der zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands hat sich im Zeitraum vom 2. September 2015 bis zum 30. Juni 2017 von 14 Prozent auf 19,2 Prozent erhöht, wenngleich das gesetzte Ziel auf dieser zweiten Führungsebene von 20 Prozent nicht ganz erreicht werden konnte. Für die nur sehr geringe Abweichung von der Zielgröße auf der zweiten Führungsebene bestehen keine spezifischen Gründe.

Die Zusammensetzung der ersten und zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands ergibt sich aus der Organisationsstruktur von SÜSS MicroTec. Die erste Führungsebene umfasst Mitarbeiter mit Personalverantwortung, die direkt an ein Vorstandsmitglied berichten. Die zweite Ebene umfasst Mitarbeiter mit Personalführung, die an die erste Führungsebene berichten.

Zum Ablauf der ersten Umsetzungsfrist beschloss der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG am 30. Juni 2017 für den Frauenanteil im Aufsichtsrat eine Zielgröße von 25 Prozent bei einer Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2022. Für den Frauenanteil im Vorstand der SÜSS MicroTec SE beschloss der Aufsichtsrat eine Zielgröße von null Prozent ebenso bei einer Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2022.

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG beschloss am 30. Juni 2017 für die erste Führungsebene unterhalb des Vorstands eine Zielgröße für den Frauenanteil von 30 Prozent bei einer Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2022, für die zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands eine Zielgröße für den Frauenanteil von 20 Prozent bei einer Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2022. Die Beschlüsse zur Zielgröße des Frauenanteils gelten nach erfolgter Umwandlung unverändert auch für die SÜSS MicroTec SE.

DIVERSITÄTSKONZEPT

Ziel der Zusammensetzung des Aufsichtsrats und des Vorstands der SÜSS MicroTec SE ist es, die Unternehmensentwicklung zu nachhaltiger Ertragskraft und permanenter Anpassung an sich schnell wandelnde Anforderungen auf der Basis relevanter Kompetenzen abzusichern. Durch eine ausreichende Kompetenzvielfalt der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen ein breites Erfahrungsspektrum und unterschiedliche Sichtweisen zum Nutzen des Unternehmens eingebracht werden.

Die SÜSS MicroTec SE ist ein auf den Weltmarkt ausgerichtetes, technologieorientiertes Unternehmen, das sich in einem sehr dynamischen und technologisch anspruchsvollen Umfeld behaupten und entwickeln muss. Das Diversitätskonzept zur Besetzung der Leistungs- und Kontrollorgane verlangt auf der einen Seite ein ausgeprägtes technologisches Beurteilungsvermögen sowie einschlägige Marktkenntnisse im internationalen Maßstab, um Trends und Entwicklungen in unseren sehr dynamischen Märkten vorausschauend und zuverlässig beurteilen zu können. Auf der anderen Seite sind insbesondere beim Vorstand neben einem tiefen technologischen Verständnis auch Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich strategischer Unternehmensentwicklung, des Kapitalmarkts, der Rechnungslegung sowie Kenntnisse im Personalwesen von Bedeutung.

Zusätzlich zu diesen genannten wichtigen Kompetenzen erwartet das Unternehmen von Aufsichtsratsmitgliedern und -kandidaten eine breite Erfahrung in anderen Bereichen, die möglichst ergänzend zu einer optimalen Besetzung des Aufsichtsrats beitragen. Folglich ist es das Ziel des Aufsichtsrats, neben dem Financial Expert erfahrene Persönlichkeiten zu gewinnen, die diese Bereiche abdecken. Aufsichtsratsmitglieder sollen neben den Fachkompetenzen über Kompetenzen zur Erarbeitung komplexer Sachverhalte wie auch über Sozialkompetenz zur konstruktiven Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums und mit dem Vorstand verfügen. In der Besetzung des Aufsichtsrats strebt das Unternehmen ein ausgewogenes Verhältnis an zwischen Mitgliedern mit langjähriger Branchen- und Markterfahrung im Halbleiter-Equipment-Bereich sowie Mitgliedern, auch branchenfremden, die Expertise in den Bereichen neue Medien und digitale Trends einbringen.

In der Festlegung der Ziele und Kriterien zur Besetzung des Aufsichtsrats im Jahr 2016 wurde festgelegt, dass bei der Besetzung des Aufsichtsrats zukünftig Frauen mit größerer Aufmerksamkeit berücksichtigt werden sollen, um eine angemessene Frauenbeteiligung zu erreichen.

Zum Stand der Umsetzung:

Mit der Besetzung des Vorstands seit Dezember 2017:

- ist der Vorstandsvorsitz mit Herrn Dr. Franz Richter besetzt, der eine große Expertise aus der Halbleiter-Equipment-Branche sowie sehr tief gehende Markt- und Technologiekenntnisse besitzt
- ist der Finanzvorstand durch Herrn Robert Leurs besetzt, welcher relevante Kenntnisse und operative Erfahrungen mitbringt, u. a. aus seiner Tätigkeit für andere international agierende Unternehmen sowie dem Bereich Wirtschaftsprüfung
- ist mit Herrn Walter Braun ein Produktionsexperte mit langjähriger und internationaler Erfahrung aus dem Technologiebereich vertreten

Mit der Besetzung des Aufsichtsrats seit Mai 2017:

- ist der Aufsichtsratsvorsitz mit Herrn Dr. Stefan Reineck besetzt, der langjährige und internationale Erfahrung aus der Equipment-Branche sowie Markt- und Technologiekenntnisse mitbringt
- ist der Financial Expert mit Herrn Jan Teichert, CFO der Einhell AG, dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, besetzt
- ist mit Herrn Gerhard Pegam ein Experte mit langjähriger und internationaler Erfahrung aus dem Technologiebereich und profunden Marktkenntnissen vertreten
- ist mit Frau Dr. Myriam Jahn eine Expertin für das Thema Digitalisierung im Maschinenbau und für die – mit Industrie 4.0 wachsende – Kundenbranche der Sensorenhersteller im Aufsichtsrat vertreten

AKTIONÄRE UND HAUPTVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der SÜSS MicroTec SE üben ihre Mitbestimmungs- und Kontrollrechte auf der mindestens einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung aus. Jede Aktie der SÜSS MicroTec SE gewährt eine Stimme. Sämtliche für die Entscheidungsfindung notwendigen Unterlagen sind entsprechend den aktienrechtlichen Vorschriften auf der Website des Unternehmens veröffentlicht und können ebenfalls in Kopie beim Unternehmen angefordert werden.

Jeder Aktionär, der im Aktienregister eingetragen ist und sich rechtzeitig anmeldet, ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, die von der Gesellschaft eingesetzten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl ausüben zu lassen. Weisungen zur Stimmrechtsausübung können schriftlich im Vorfeld oder während der Hauptversammlung direkt vor Ort erteilt werden.

RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG

SÜSS MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie die Zwischenberichte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union für börsennotierte Gesellschaften anzuwenden sind, und den ergänzend gemäß §315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für Konzernabschlüsse. Der Einzelabschluss der SÜSS MicroTec SE wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Am 31. Mai 2017 wählte die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017 die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec SE. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Des Weiteren wurde mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass dieser den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse informiert, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben.

RISIKOMANAGEMENT

Der verantwortungsbewusste Umgang mit geschäftlichen Risiken gehört zu den Grundsätzen guter Corporate Governance. Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist ein Risikomanagementsystem seit langem Bestandteil der Unternehmensführung bei SÜSS MicroTec. Dieses wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich durch den Wirtschaftsprüfer geprüft.

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagementsystems wurde ein Risikomanagementbeauftragter ernannt, der regelmäßig direkt an den Vorstand berichtet. Der Vorstand seinerseits informiert den Aufsichtsrat regelmäßig über bestehende Risiken und deren Entwicklung.

Einzelheiten zum Risikomanagement im SÜSS MicroTec-Konzern sind im Risikobericht, der Teil des Lageberichts ist, dargestellt. Hierin ist der gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) geforderte Bericht zum rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und Risikomanagementsystem enthalten.

TRANSPARENZ

Die SÜSS MicroTec SE informiert Aktionäre, Analysten, Aktionärsvereinigungen, Medien und die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig und zeitnah über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die Lage des Konzerns. Die verschiedenen Zielgruppen werden dabei gleichzeitig und gleichberechtigt behandelt. Alle kapitalmarktrelevanten Informationen sind zudem auf der Website des Unternehmens veröffentlicht und frei einsehbar. Die wesentlichen wiederkehrenden Termine und Ereignisse sind im Finanzkalender des Unternehmens zusammengestellt. Dieser wird mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf veröffentlicht und ist auf der Website des Unternehmens einsehbar unter www.suss.com > *Investor Relations* > *Finanzkalender*.

NICHTFINANZIELLE KONZERNERKLÄRUNG GEMÄSS § 315B HGB

Der Vorstand der SÜSS MicroTec SE hat gemäß den Vorgaben des § 315b Abs. 1, 3 HGB eine nichtfinanzielle Konzernklärung für das Geschäftsjahr 2017 erstellt. Die Erklärung wird in einem gesonderten nichtfinanziellen Bericht gemäß §§ 315b, 315c HGB im Bundesanzeiger zusammen mit dem zusammengefassten

Lagebericht sowie auf der Internetseite des Unternehmens unter www.suss.com > *Investor Relations* > *Veröffentlichungen* zugänglich gemacht.

VERGÜTUNGSBERICHT

VERGÜTUNG DES VORSTANDS

SÜSS MicroTec legt die Vorstandsvergütung bereits seit mehreren Jahren individualisiert offen. Ziel des Systems der Vorstandsvergütung bei SÜSS MicroTec ist es, einen Anreiz für die langfristige und auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung zu setzen. Besondere Leistungen sollen entsprechend vergütet werden. Aber auch Zielverfehlungen müssen zu einer spürbaren Verringerung der Vergütung führen; darüber hinaus muss sich die Vergütung an der Größe und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens orientieren. Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Vergütungsbestandteilen.

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat zuständig. Das Aufsichtsratsplenum beschließt und überprüft auf regelmäßiger Basis das Vergütungssystem für den Vorstand und beschließt über die Vorstandsverträge.

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der Ausrichtung der Vorstandsvergütung an einer nachhaltigen Unternehmensführung befasst. Hierzu wird regelmäßig ein externer Vergütungsberater hinzugezogen.

FESTE VERGÜTUNG

Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. Die erfolgsunabhängigen Teile der Vergütung bestehen aus dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und Zuschüssen zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherungen) bestehen nicht.

ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG

Die erfolgsbezogene Vergütung besteht aus einer variablen Vergütung.

VARIABLE VERGÜTUNG

Seit dem 1. Januar 2016 kann die variable Vergütung für alle Vorstandsmitglieder höchstens 100 Prozent der Festvergütung zu Beginn des Geschäftsjahres betragen. Die Regelungen gelten auch für künftige Geschäftsjahre. 70 Prozent der variablen Vergütung bestimmen sich nach Jahreszielen und 30 Prozent nach Mehrjahreszielen.

AN JAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE VERGÜTUNG (VARIABLE VERGÜTUNG A)

70 Prozent der variablen Vergütung entfallen auf Jahresziele, die für jeweils ein Geschäftsjahr vom Aufsichtsrat festgelegt werden.

Für die Geschäftsjahre ab 2016 finden folgende Jahresziele Anwendung: Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Return on Investment (ROI), wobei die Gewichtung der Jahresziele unterschiedlich ist.

Werden die Jahresziele – Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow – zu 70 Prozent und das Jahresziel ROI zu 90 Prozent oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 130 Prozent ist bei den Zielen Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow der Maximalbetrag erreicht, bei dem Ziel ROI bei einer Zielerreichung von 110 Prozent. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel – Auftragseingang, Umsatz, EBITDA oder Free Cashflow – zwischen 70 Prozent und 130 Prozent, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln. Für das Ziel ROI liegt die Bandbreite entsprechend zwischen 90 Prozent und 110 Prozent.

Die an Jahreszielen orientierte Vergütung wird jährlich ermittelt. Im Interesse einer Förderung der langfristigen Unternehmensentwicklung steht den Vorstandsmitgliedern zunächst aber nur die Hälfte der variablen Vergütung A endgültig zu. In Bezug auf die andere Hälfte des Auszahlungsbetrags (Vorbehaltshälfte) ist das Vorstandsmitglied verpflichtet, in dem ersten Handelsfenster nach Auszahlung des Auszahlungsbetrags Aktien der Gesellschaft zu erwerben und für eine Sperrfrist von drei Jahren, gerechnet ab dem letzten Tag des Handelsfensters, in dem die Aktien erworben wurden, in einem auf seinen Namen lautenden Depot zu halten.

AN MEHRJAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE VERGÜTUNG (VARBIABLE VERGÜTUNG B)

30 Prozent der variablen Vergütung entfallen auf mehrjährige Ziele, die für einen Zeitraum von regelmäßig drei Geschäftsjahren festgelegt werden.

Die Ziele für die Geschäftsjahre 2016 bis 2018 bestehen aus einer Kombination von Umsatz und Bruttogewinnmarge (Gross-Profit-Marge) und betreffen zum einen den SÜSS MicroTec-Konzern insgesamt und zum anderen das Segment Bonder sowie die in den USA angesiedelten Produktlinien. Die Gewichtung dieser Mehrjahresziele ist unterschiedlich. Für jedes Ziel und jedes Geschäftsjahr hat der Aufsichtsrat unterschiedliche Zielerreichungsgrade definiert. So variieren die unteren Grenzen der Zielerreichungsgrade je nach Ziel und Geschäftsjahr zwischen 84,4 Prozent und 98,0 Prozent, die oberen Grenzen zwischen 104,1 Prozent und 115,6 Prozent. Werden die unteren Grenzen der Zielerreichungsgrade erreicht oder unterschritten, entfällt die Vergütungskomponente für das jeweilige Teilziel. Werden die oberen Grenzen der Zielerreichungsgrade erreicht oder überschritten, fällt der Maximalbetrag für das jeweilige Teilziel an. Liegt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel dazwischen, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln. Die an Mehrjahreszielen orientierte variable Vergütung B wird jährlich ermittelt und für das jeweilige Geschäftsjahr vollständig ausgezahlt.

ABFINDUNGEN

In Vorstandsverträgen ist für den Fall, dass die Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine Ausgleichszahlung vorgesehen. Diese ist auf maximal zwei Jahresvergütungen einschließlich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als die Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrags. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels (Change-of-Control-Regelung) ist in den bestehenden Vorstandsverträgen nicht enthalten.

VORSTANDSVERGÜTUNG

Die im Folgenden aufgeführten Tabellen zur Vorstandsvergütung entsprechen dem Deutschen Corporate Governance Kodex. Die Festvergütung und die Nebenleistungen richten sich nach dem vereinbarten Festbetrag. Für die variable Vergütung ist sowohl ein Zielwert für eine Erreichung von 100 Prozent angegeben als auch die erreichbare Minimal- und Maximalvergütung.

HÖHE DER VORSTANDSVERGÜTUNG

Die folgenden Tabellen („Gewährte Zuwendungen“ und „Zufluss“) zeigen die Vergütung für die Geschäftsjahre 2017 und 2016 je Vorstandsmitglied gemäß den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex Ziffer 4.2.5 Abs. 3.

Zielvergütung des Vorstands nach dem Deutschen Corporate Governance Kodex:

Dr. Franz Richter Vorstandsvorsitzender (CEO) Eintritt: 07.09.2016				
<i>in €</i>				
Gewährte Zuwendungen	2016 (100 %)	2017 (100 %)	2017 (Min.)	2017 (Max.)
Festvergütung	114.545,45	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Nebenleistungen (fix) ¹	10.570,08	33.392,16	33.392,16	33.392,16
Aufwand für Altersversorgung ²	–	–	–	–
Summe	125.115,53	393.392,16	393.392,16	393.392,16
Einjährige variable Vergütung (A) ³	39.550,00	126.000,00	–	252.000,00
davon Investitionen in SÜSS MicroTec-Aktien ⁴	19.775,00	63.000,00	–	126.000,00
Mehrjährige variable Vergütung 2016–2018 (B) ³	16.950,00	54.000,00	–	108.000,00
Summe	181.615,53	573.392,16	393.392,16	753.392,16
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	181.615,53	573.392,16	393.392,16	753.392,16

¹ Enthält:

Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
geldwerten Vorteil Pkw bzw. Fahrzeugpauschale
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenversicherung

² Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung).

³ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 100 Prozent der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres.

⁴ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

Robert Leurs Finanzvorstand (CFO) Eintritt: 01.12.2017				
<i>in €</i>				
Gewährte Zuwendungen	2016 (100 %)	2017 (100 %)	2017 (Min.)	2017 (Max.)
Festvergütung	–	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Nebenleistungen (fix) ¹	–	1.913,09	1.913,09	1.913,09
Aufwand für Altersversorgung ²	–	–	–	–
Summe	–	26.913,09	26.913,09	26.913,09
Einjährige variable Vergütung (A) ³	–	8.750,00	–	17.500,00
davon Investitionen in SÜSS MicroTec-Aktien ⁴	–	4.375,00	–	8.750,00
Mehrjährige variable Vergütung 2016–2018 (B) ³	–	3.750,00	–	7.500,00
Summe	–	39.413,09	26.913,09	51.913,09
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	–	39.413,09	26.913,09	51.913,09

¹ Enthält:

Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
geldwerten Vorteil Pkw bzw. Fahrzeugpauschale
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenversicherung

² Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung).

³ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 100 Prozent der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres.

⁴ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

in €	Walter Braun Produktionsvorstand (COO)			
	2016 (100 %)	2017 (100 %)	2017 (Min.)	2017 (Max.)
Gewährte Zuwendungen				
Festvergütung	230.004,00	230.004,00	230.004,00	230.004,00
Nebenleistungen (fix) ¹	19.146,84	19.679,20	19.679,20	19.679,20
Aufwand für Altersversorgung ²	–	–	–	–
Summe	249.150,84	249.683,20	249.683,20	249.683,20
Einjährige variable Vergütung (A) ³	80.500,00	80.500,00	–	161.000,00
davon Investitionen in SÜSS MicroTec-Aktien ⁴	40.250,00	40.250,00	–	80.500,00
Mehrjährige variable Vergütung 2016–2018 (B) ³	34.500,00	34.500,00	–	69.000,00
Summe	364.150,84	364.683,20	249.683,20	479.683,20
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	364.150,84	364.683,20	249.683,20	479.683,20

¹ Enthält:
 Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
 geldwerten Vorteil Pkw bzw. Fahrzeugpauschale
 Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenversicherung

² Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung).

³ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 100 Prozent der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres.

⁴ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

in €	Michael Knopp Finanzvorstand (CFO) Austritt: 30.04.2017			
	2016 (100 %)	2017 (100 %)	2017 (Min.)	2017 (Max.)
Gewährte Zuwendungen				
Festvergütung	280.000,00	93.333,33	93.333,33	93.333,33
Nebenleistungen (fix) ¹	22.052,84	7.557,12	7.557,12	7.557,12
Aufwand für Altersversorgung ²	2.148,00	–	–	–
Summe	304.200,84	100.890,45	100.890,45	100.890,45
Einjährige variable Vergütung (A) ³	98.000,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
davon Investitionen in SÜSS MicroTec-Aktien ⁴	49.000,00	–	–	–
Mehrjährige variable Vergütung 2016–2018 (B) ³	42.000,00	–	–	–
Summe	444.200,84	147.590,45	147.590,45	147.590,45
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	444.200,84	147.590,45	147.590,45	147.590,45

¹ Enthält:
 Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
 geldwerten Vorteil Pkw bzw. Fahrzeugpauschale
 Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenversicherung

² Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung).

³ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 100 Prozent der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres.

⁴ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

Zufluss der Vorstandsvergütung nach dem Deutschen Corporate Governance Kodex:

in €	Dr. Franz Richter Vorstandsvorsitzender (CEO) Eintritt: 07.09.2016		Walter Braun Produktionsvorstand (COO)	
	2016	2017	2016	2017
Zufluss				
Festvergütung	114.545,45	360.000,00	230.004,00	230.004,00
Nebenleistungen (fix) ¹	10.570,08	33.392,16	19.146,84	19.679,20
Aufwand für Altersversorgung ²	–	–	–	–
Abfindungszahlungen ³	–	–	–	–
Summe	125.115,53	393.392,16	249.150,84	249.683,20
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	31.451,17	187.155,74	64.015,66	119.571,73
davon Investitionen in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	15.725,59	93.577,87	32.007,83	59.785,87
Mehrjährige variable Vergütung 2016 – 2018 (B) ⁴	12.631,85	86.400,00	25.710,83	55.200,00
Summe	169.198,55	666.947,90	338.877,33	424.454,93
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	169.198,55	666.947,90	338.877,33	424.454,93

¹ Enthält:

Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
geldwerten Vorteil PKW bzw. Fahrzeugpauschale
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse

² Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung).

³ Abgeltung für Aufhebung Dienstvertrag (urspr. Restlaufzeit bis 30.04.2018) und Bonus 2016.

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 100 Prozent der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres.

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

in €	Robert Leurs Finanzvorstand (CFO) Eintritt: 01.12.2017		Michael Knopp Finanzvorstand (CFO) Austritt: 30.04.2017	
	2016	2017	2016	2017
Zufluss				
Festvergütung	–	25.000,00	280.000,00	93.333,33
Nebenleistungen (fix) ¹	–	1.913,09	22.052,84	7.557,12
Aufwand für Altersversorgung ²	–	–	2.148,00	–
Abfindungszahlungen ³	–	–	–	–
Summe	–	26.913,09	304.200,84	100.890,45
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	–	12.996,93	77.932,11	46.700,00
davon Investitionen in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	–	6.498,47	38.966,06	–
Mehrjährige variable Vergütung 2016 – 2018 (B) ⁴	–	6.000,00	31.300,14	–
Summe	–	45.910,02	413.433,09	147.590,45
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	–	45.910,02	413.433,09	147.590,45

¹ Enthält:

Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
geldwerten Vorteil PKW bzw. Fahrzeugpauschale
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse

² Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung).

³ Abgeltung für Aufhebung Dienstvertrag (urspr. Restlaufzeit bis 30.04.2018) und Bonus 2016.

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 100 Prozent der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres.

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

Zufluss der Vorstandsvergütung nach dem Deutschen Corporate Governance Kodex:

<i>in €</i>	Dr. Per-Ove Hansson Vorstandsvorsitzender (CEO) <i>Austritt: 16.08.2016</i>	
	2016	2017
Zufluss		
Festvergütung	356.668,00	–
Wechselprämie	100.000,00	–
Nebenleistungen (fix) ¹	24.579,60	–
Aufwand für Altersversorgung ²	–	–
Abfindungszahlungen ³	750.000,00	–
Summe	1.231.247,60	–
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	–	–
davon Investitionen in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	–	–
Mehrjährige variable Vergütung 2016–2018 (B) ⁴	–	–
Summe	1.231.247,60	–
Versorgungsaufwand	–	–
Gesamtvergütung	1.231.247,60	–

¹ Enthält:
 Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
 geldwerten Vorteil PKW bzw. Fahrzeugpauschale
 Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse

² Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung).

³ Abgeltung für Aufhebung Dienstvertrag (urspr. Restlaufzeit bis 30.04.2018) und Bonus 2016.

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 100 Prozent der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres.

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

PENSIONEN

Es bestehen keine Pensionsverpflichtungen für Mitglieder oder ehemalige Mitglieder des Vorstands.

VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 20 der Satzung der SÜSS MicroTec SE geregelt. Neben der Erstattung seiner Auslagen und einem Sitzungsgeld von 2.000,00 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an seiner Verantwortung und seinem Tätigkeitsumfang orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 60.000,00 €, sein Stellvertreter 50.000,00 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 45.000,00 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben der Gesellschaft den rechnerischen Pro-Kopf-Anteil der von der Gesellschaft gezahlten D&O-Versicherungsprämie erstattet.

2017 in €	Vergütung	Sitzungsgeld
Aufsichtsrat		
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender)	60.000,00	14.000,00
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	50.000,00	14.000,00
Gerhard Pegam	45.000,00	14.000,00
Dr. Myriam Jahn (ab 31.05.2017)	26.250,00	8.000,00

2016 in €	Vergütung	Sitzungsgeld	Abzug für anteilige D&O-Versicherungsprämie
Aufsichtsrat			
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender)	60.000,00	16.000,00	1.655,18
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	50.000,00	16.000,00	827,59
Gerhard Pegam	45.000,00	16.000,00	551,73

Im Geschäftsjahr 2017 haben weder die Mitglieder des Aufsichtsrats noch ihnen nahestehende Personen oder Unternehmen eine Vergütung bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.

CHANCEN UND RISIKEN FÜR DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG DES SÜSS MICROTREC-KONZERNS

Unser Chancen- und Risikomanagement zielt darauf ab, den Unternehmenswert des SÜSS MicroTec-Konzerns nachhaltig zu sichern und zu steigern. Zu unserer unternehmerischen Zielsetzung gehören das frühzeitige und erfolgreiche Erkennen von Chancen sowie die Identifikation und angemessene Bewertung der damit verbundenen Risiken und die adäquate Reaktion darauf. Die vielfältigen Chancen für unseren Konzern resultieren aus der Technologieführerschaft in unseren Geschäftsfeldern, unserem breiten Spektrum an Produkten und Lösungen für die Halbleiter-Equipment-Industrie, den Kooperationen mit internationalen Kunden und Forschungsinstituten sowie unserer globalen Ausrichtung.

Chancen und Risiken definieren wir wie folgt:

- Chancen sind mögliche künftige Entwicklungen oder Ereignisse, die zu einer für den Konzern positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.
- Unter Risiken verstehen wir mögliche künftige Entwicklungen oder Ereignisse, die zu einer für den Konzern negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.

Die Analyse und Beurteilung der Chancen und Risiken des Konzerns ist Gegenstand fortlaufender Betrachtungen durch den Vorstand und das Management des Konzerns. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

CHANCEN DES KONZERNS

Die globale Geschäftstätigkeit des SÜSS MicroTec-Konzerns innerhalb eines dynamischen Marktumfelds eröffnet ständig neue Chancen, die das angestrebte Wachstum von SÜSS MicroTec unterstützen und vorantreiben können. Das Erkennen und Nutzen dieser Chancen gehört daher zu den wesentlichen Bestandteilen unserer Wachstumspolitik.

Gesamtwirtschaftliche Chancen

SÜSS MicroTec ist mit Produktions-, Verkaufs- und Serviceniederlassungen weltweit vertreten und arbeitet darüber hinaus mit vielen externen Handelspartnern zusammen. Durch die internationale Präsenz bieten sich dem Konzern zahlreiche Chancen, weltweit neue Kunden zu akquirieren, neue Kooperationen einzugehen und an dem Wachstum der Industriemärkte in den bedeutenden und aufstrebenden Volkswirtschaften teilzuhaben.

Unternehmensstrategische Chancen

SÜSS MicroTec hat in der Herstellung von Prozessausrüstungen für die Halbleiterindustrie Standards in Präzision und Qualität gesetzt. Kontinuierliche Innovationsleistungen und die Fähigkeit, stets neue Lösungen in einem sich schnell ändernden Umfeld bereitzustellen, haben SÜSS MicroTec zum Technologieführer gemacht. Diese Stärken zusammen mit einer soliden finanziellen Ausstattung geben dem Konzern die Möglichkeit, aussichtsreiche Entwicklungsprojekte durchzuführen, erfolgversprechende Kooperationen einzugehen und damit die Produktpalette weiter auszubauen sowie Anwendungen und Technologien weiterzuentwickeln. Der SÜSS MicroTec-Konzern pflegt zahlreiche Entwicklungspartnerschaften mit Forschungsinstituten und Universitäten. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten bietet großes Potenzial für SÜSS MicroTec, denn diese arbeiten in der Regel sehr eng mit unseren Kunden zusammen und werden zu einem nicht unerheblichen Anteil durch die Kunden finanziert. Neue Basistechnologien werden häufig in den Laboren der Forschungsinstitute entwickelt und finden dann erst ihren Weg in die Industrie. Umso wichtiger ist es für ein Hightech-Unternehmen wie SÜSS MicroTec, von Anfang an in die Neuentwicklung von Technologien und Prozessen miteingebunden zu sein. Dies erhöht die Chancen, später Maschinen und Lösungen für das industrielle Umfeld in der Volumenproduktion liefern zu können.

Neben der Weiterentwicklung eigener Technologien sieht SÜSS MicroTec grundsätzlich auch die Chance, den Konzern durch Akquisition von außen um neue Geschäftsfelder und Technologien zu erweitern.

Branchen- und marktspezifische Chancen

Grenzenlose Mobilität, autonomes Fahren, Industrie 4.0/Smart Factory – all das wäre ohne leistungsfähige Chips nicht denkbar. Die technisch anspruchsvolle Fertigung dieser Chips erfolgt in mehreren komplexen Bearbeitungsschritten (Mikrostrukturierung), wofür die Chiphersteller entsprechende Spezialmaschinen benötigen. Diese Spezialmaschinen entwickelt und baut SÜSS MicroTec.

Die von SÜSS MicroTec bedienten Märkte der Halbleiter-Equipment-Industrie unterliegen einem stetigen Wandel, der vor allem durch die rasanten Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie beeinflusst wird. So sind insbesondere die zahlreichen Funktionen von Smartphones und Tablets ein Haupttreiber des Geschäfts in der Halbleiter-Equipment-Industrie. Die Anzahl der in Smartphones und Tablets enthaltenen unterschiedlichen Bauelemente – wie zum Beispiel Speicherchips, Sensoren für Fingerprint- und Gesichtserkennung, Image-Sensoren für die Kamera – steigert die Nachfrage der Smartphone-Hersteller nach leistungsfähigen Chips, was wiederum zu einer gesteigerten Nachfrage nach Halbleiter-Equipment führt. Auch in der Automobilindustrie führen die Neu- und Weiterentwicklungen im Bereich autonomes Fahren und immer weiter verbesserte Assistenzsysteme zu einer hohen Nachfrage nach leistungsfähigen Chips. Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend in den kommenden Jahren weiter anhalten wird.

Die zunehmende Nachfrage nach Smartphones, Tablets und Wearables mit komplexen Bauteilen sowie nach leistungsfähigen Sensoren für die Automobilindustrie fördert den Umsatz von SÜSS MicroTec bei mehreren Produkten. Unsere Mask-Aligner, Belacker und Bonder werden von unseren Kunden eingesetzt, um Chips mit Strukturen zu versehen und um zahlreiche Sensoren, die in jedem Smartphone enthalten sind, herzustellen.

Die starken Marktzyklen der Halbleiterindustrie bieten SÜSS MicroTec – je nach Art der Entwicklung – zahlreiche neue Chancen im Markt, die kurzfristig für einen starken Anstieg der Auftragsgänge und der Umsätze sorgen können.

Unser globales Netzwerk von Vertriebsmitarbeitern, Produktingenieuren und Handelspartnern ist darauf ausgerichtet, die branchen- und marktspezifischen Anforderungen unserer Kunden weltweit zu erfüllen. SÜSS MicroTec ist in den Kernmärkten der Halbleiter-Equipment-Industrie in Taiwan, China, Singapur, Südkorea und Japan mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten. Unsere Niederlassungen pflegen stets den direkten Kontakt mit unseren Kunden und haben damit die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen auf den Halbleitermärkten umgehend zu registrieren. Damit kann SÜSS MicroTec rasch auf sich abzeichnende Neuentwicklungen reagieren und seine Anwendungen entsprechend anpassen.

Um neue Entwicklungen am Markt immer schnell wahrzunehmen, ist uns der direkte und regelmäßige Kontakt zu Kooperationspartnern, Kunden und potenziellen Neukunden sehr wichtig. SÜSS MicroTec ist daher auf Messen für die Halbleiterindustrie vertreten und veranstaltet internationale Technologieforen.

So stellt SÜSS MicroTec seine Neuentwicklungen regelmäßig auf den SEMICON-Messen vor, die jährlich an verschiedenen Standorten weltweit stattfinden. In 2017 war SÜSS MicroTec auf den SEMICON-Messen in Korea (Seoul), China (Shanghai), Taiwan (Taipeh) und Europa (München) vertreten und hat die neuesten Technologien der verschiedenen Produktlinien präsentiert. Auf allen Messen konnten zahlreiche Besuche von Kunden und Interessenten verzeichnet werden. Parallel zur SEMICON China nahm SÜSS MicroTec auch auf der Laser World of Photonics CHINA teil, die ebenfalls in Shanghai stattfand. Auf dieser Messe werden regelmäßig die neuesten Anwendungen und Technologien der Laser- und Photonikindustrie vorgestellt. SÜSS MicroTec präsentierte seine Technologien und Anwendungen außerdem auf dem SEMI MEMS Summit in Grenoble, Frankreich, und auf der 3D ASIP in San Francisco, Kalifornien, USA.

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Branchenverband SEMI und zahlreichen internationalen Forschungsinstituten kann SÜSS MicroTec einen großen Adressatenkreis ansprechen. Die internationale Präsenz von SÜSS MicroTec und der durch die Messen und Veranstaltungen hohe Bekanntheitsgrad geben uns die Möglichkeit, das Ohr immer direkt am Markt zu haben und auf technologische Fortschritte und Neuentwicklungen schnell zu reagieren.

Operative Chancen

Die Lithografie ist nach wie vor der größte Unternehmensbereich der SÜSS MicroTec-Gruppe und sorgt jährlich für etwa zwei Drittel des gesamten Konzernumsatzes. Mit den Produktlinien Mask-Aligner und Belacker/Entwickler ist SÜSS MicroTec seit vielen Jahren erfolgreich am Markt vertreten und bedient damit Kunden aus verschiedenen Branchen und Märkten. Das konstante Umsatzvolumen und die relativ stabilen Margen dieser beiden Produktlinien sichern dem SÜSS MicroTec-Konzern eine gleichmäßige Auslastung der Produktionsstandorte Garching und Sternenfels und beständige positive Cashflows. Mit Weiterentwicklungen und Verbesserungen der Technologien dieser beiden Produktlinien festigen wir unsere Marktposition und stellen sicher, dass mit Mask-Alignern und Belackern/Entwicklern auch zukünftig stabile Margen und Cashflows erzielt werden können.

Die Technologien der SÜSS MicroTec Photonic Systems – die UV-Projektionsbelichtung und die Laserprozessierung – ergänzen und erweitern unser Produktportfolio im Bereich Lithografie. Mit beiden Produktlinien wurden in 2017 nur geringe Umsätze erzielt. Seit 2016 wird an einem umfassenden Weiterentwicklungsprojekt für die UV-Projektionsscanner gearbeitet, das im Geschäftsjahr 2017 erste Erfolge zeigt. Aufgrund der sehr überzeugenden Testergebnisse bei der Weiterentwicklung des Projektionsscanners DSC300 und der äußerst positiven Rückmeldungen seitens potenzieller Kunden gehen wir davon aus, dass die Markteinführung der nächsten Produktgeneration wie geplant im zweiten Quartal 2018 erfolgen kann. Nennenswerte Umsätze sowie eine deutlich verbesserte Ergebnissituation für die beiden Produktlinien werden ab dem Geschäftsjahr 2019 erwartet. Wenn es uns gelingt, weitere Kunden von unseren Systemen zu überzeugen, könnten wir auch in den dann folgenden Jahren weiter substanzielle Auftragsvolumina und Umsätze mit Scannern erzielen. Bei entsprechend hohen Stückzahlen könnten zukünftig nachhaltig positive Margen erreicht werden.

Das Segment Bonder untergliedert sich in die beiden Teilbereiche temporäres und permanentes Bonden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden gegenüber 2016 in beiden Produktlinien deutlich mehr Aufträge gewonnen. In der Produktlinie temporäres Bonden ist es uns gelungen, Aufträge für die Volumenproduktion bei der 3D-Integration zu gewinnen und den Umsatz mit unseren Systemen deutlich zu steigern. Auch die Produktlinie permanentes Bonden konnte im Auftragsingang und Umsatz gegenüber Vorjahr zulegen. Insbesondere die XB8 für Anwendungen im MEMS-Bereich trug zum Erfolg der Produktlinie bei. In 2017 konnte in diesem Segment erstmals ein deutlich positives Jahresergebnis erzielt werden. Damit hat sich das Segment Bonder im Konzern als Geschäftsfeld etabliert, aus dem zukünftig stabile Umsatz- und Ergebnisbeiträge zu erwarten sind. Wir gehen fest davon aus, dass wir in dem Segment unseren Marktanteil festigen und ausbauen können und zukünftig in beiden Produktlinien neue Kunden und margenträchtige Aufträge gewinnen werden.

Im Segment Fotomaschinen-Equipment haben wir seit der Akquisition der SÜSS MicroTec Photomask Equipment im Jahr 2010 hohe Umsätze und hohe Margen erzielt. Der Großteil der Umsätze wurde mit wenigen Einzelaufträgen erzielt, die jeweils einen sehr hohen Auftragswert von mehreren Millionen Euro aufwiesen. Die Umsätze pro Geschäftsjahr weisen daher große Schwankungen auf. In diesem Segment sehen wir unsere Marktposition als sehr gefestigt an und gehen davon aus, auch in Zukunft hohe Gewinne zu erzielen. Wir rechnen jedoch damit, dass sich langfristig weiterhin starke Schwankungen im Umsatz pro Geschäftsjahr ergeben werden, was sich entsprechend auf das Segmentergebnis pro Geschäftsjahr auswirken kann. In 2017 konnten Lizenzerträge aus der Übertragung von Prozess-Know-how in Höhe von rund 2 Mio. € realisiert werden. In Abhängigkeit von den vom Lizenznehmer verkauften Produkten könnten in den kommenden drei Jahren bis zu 3 Mio. € weitere Lizenzerträge erzielt werden.

Das Geschäft der SÜSS MicroOptics S.A., Hauterive, Schweiz, hat sich auch im Jahr 2017 sehr positiv entwickelt. Im MicroOptics-Geschäft konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzsteigerungen von rund 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Im Jahr 2017 wurden weitere Investitionen in Maschinen und technische Anlagen vorgenommen, um der guten Auftragslage Rechnung zu tragen. Für die kommenden Jahre erwarten wir weitere Umsatzsteigerungen im MicroOptics-Geschäft und gehen davon aus, dass die SÜSS MicroOptics in Zukunft einen substanziellen Umsatz- und Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis leisten wird.

Finanzielle Chancen

Starke Veränderungen am Währungsmarkt können den Absatz und das Unternehmensergebnis von SÜSS MicroTec sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Die Wertveränderungen des Euro im Vergleich zum US-Dollar oder japanischen Yen werden künftig den Absatz und die erzielbaren Margen im nordamerikanischen und asiatischen Raum beeinflussen. Eine Aufwertung des Euro im Vergleich zum US-Dollar oder japanischen Yen würde sich eher negativ auswirken, während eine Abwertung voraussichtlich positive Effekte für SÜSS MicroTec nach sich ziehen würde.

Mitarberspezifische Chancen

SÜSS MicroTec sieht sich selbst als mittelständisches Unternehmen, das aufgrund der relativ geringen Unternehmensgröße flache Hierarchien aufweist und so seinen Mitarbeitern in allen Belangen kurze Kommunikationswege und schnelle Entscheidungsprozesse ermöglicht. Unsere mittelständischen Strukturen in Verbindung mit unserer internationalen Ausrichtung machen SÜSS MicroTec zu einem attraktiven Arbeitgeber. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit unserer weltweit tätigen Mitarbeiter beläuft sich auf beinahe zehn Jahre. Damit zeigen unsere Bemühungen, unseren Mitarbeitern ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, mit einem guten Betriebsklima, interessanten Aufgaben und einer attraktiven Vergütung, ihren Erfolg. Wir sind überzeugt, dass wir auch zukünftig alle freien Stellen mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitern besetzen können. Unsere bisherige Strategie, langjährige Mitarbeiter zu halten, werden wir unverändert fortsetzen.

Unser Vergütungssystem beinhaltet für unsere Führungskräfte eine variable Vergütung, deren Höhe sich nach dem Grad der Zielerreichung richtet. Die Ziele werden jährlich neu definiert und basieren auf bestimmten Kenngrößen des Konzerns (wie zum Beispiel EBITDA, Umsatz und Auftragseingang), die anhand der aktuellen Budgetplanung jährlich neu festgelegt werden. Zusätzlich werden mit dem Mitarbeiter persönliche Ziele vereinbart. Für die Mitarbeiter des Vertriebs werden in der Regel Ziele definiert, die im Zusammenhang mit der Gewinnung von Kundenaufträgen stehen. Die persönlichen Ziele von Mitarbeitern anderer Abteilungen haben meist Leistungen oder Projekte zum Inhalt, die einen Zusatznutzen für den jeweiligen Fachbereich mit sich bringen. Durch die Einbindung der Budgetplanung in das Vergütungssystem setzen wir für unsere Führungskräfte einen finanziellen Anreiz, aktiv dazu beizutragen, die gesetzten Ziele zu erreichen. Damit erhöhen wir unsere Chancen, unseren geplanten Umsatz und unser geplantes Ergebnis tatsächlich zu erzielen. Die Definition von persönlichen Zielen für die Führungskräfte bietet uns darüber hinaus die Chance, zahlreiche Projekte in verschiedenen Bereichen umzusetzen, auch wenn dafür ein Arbeitseinsatz der Mitarbeiter notwendig ist, der über das normale Tagesgeschäft hinausgeht.

Als weltweit erfolgreiches Technologieunternehmen ist SÜSS MicroTec darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter, die im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind, neue Produktentwicklungen gezielt vorantreiben, um so den Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung zu tragen. SÜSS MicroTec setzt hierzu die entsprechenden Anreize und vergütet Ideen der Mitarbeiter, die in unseren Produkten zum Einsatz kommen, mit einer jährlich auszuzahlenden Erfindervergütung.

Unsere internationale Präsenz ermöglicht es uns, hochqualifizierte Mitarbeiter weltweit anzuwerben, wenn es aktuelle Entwicklungen erforderlich machen.

Entwicklungsspezifische Chancen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir unsere Entwicklungsaktivitäten weiter ausgebaut und unsere Mitarbeiterzahl in diesem Bereich weiter erhöht. Mehrere Entwicklungsprojekte für unsere Produktlinien Mask-Aligner und Belacker/Entwickler sowie Bonder und Fotomaskenreinigung wurden erfolgreich zum Abschluss gebracht. Bei der Produktlinie Mask-Aligner lagen die Schwerpunkte vor allem auf einer erneuerten Softwareplattform und verschiedenen Neuerungen, die die Bedienung der Maschinen vereinfachen und die Kosteneffizienz positiv beeinflussen. Bei den Belackern/Entwicklern lag der Fokus auf der Qualifizierung der neuen ACS300-Gen3-Plattform für spezielle Anwendungen, die von asiatischen Kunden gefordert wurden, und auf verschiedenen Maßnahmen, die die Bedienbarkeit der Maschinen verbessern. Für die Produktlinie UV-Projektionsscanner wurde intensiv an der Entwicklung einer neuen Plattform des Projektionsscanners DSC300 Gen3 gearbeitet. In den Bereichen permanentes und temporäres Bonden sowie in der Fotomaskenreinigung konnten zahlreiche Verbesserungen sowie neue Technologien eingeführt werden.

Wir werden unsere Anstrengungen auch im kommenden Jahr fortsetzen und die Schwerpunkte weiter auf Kosteneffizienz und Umweltverträglichkeit sowie die Entwicklung neuer und die Verbesserung bestehender Technologien legen. Unser Ziel ist es, unsere Produktlinien an die neuesten Entwicklungen im Markt anzupassen und neue Kundenanforderungen zu erfüllen. Damit wollen wir unsere Marktposition festigen und weiter ausbauen.

RISIKOMANAGEMENTSYSTEM

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist das Risikomanagementsystem seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagementsystems wurde ein Risikomanagementbeauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Extern wird das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem durch den Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geprüft. Er berichtet darüber an Vorstand und Aufsichtsrat.

Risikoidentifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen. Im Rahmen eines strukturierten Prozesses werden vierteljährlich sämtliche identifizierten Risiken mit Hilfe einer intranetbasierten IT-Lösung erfasst und bewertet. Anschließend werden Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagementbeauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Die Aufbereitung der Informationen erfolgt durch den Risikomanagementbeauftragten, der an den Vorstand berichtet. Die Ergebnisse des Gesamtprozesses werden dem Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich präsentiert.

Wichtiger Bestandteil zur Risikofrüherkennung ist das Qualitätsmanagement des Konzerns. An den großen Produktionsstandorten liegt eine Zertifizierung nach ISO 9001 vor, die ein zuverlässiges, prozess- und systemorientiertes Qualitätsmanagement bestätigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements sorgen nicht nur für Transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten Produktionskunden eine Vorbedingung für die erfolgreiche Vermarktung unserer Maschinen.

Risikobewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, wobei auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen berücksichtigt werden. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden zwölf bzw. 24 Monate.

Die identifizierten Risiken werden mit Hilfe einer Risikomatrix in drei verschiedene Risikokategorien eingeordnet, die sowohl die mögliche Schadenshöhe als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigen. Risiken ab einer Schadenshöhe von 10 Mio. € – gemessen an der Höhe des Liquiditätsabflusses – werden als „bestandsgefährdend“ angesehen.

Die Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und Grad der Auswirkung bestimmt, welche Risikokategorien aus Konzernsicht als wesentlich zu betrachten sind. Hierbei wird unterschieden in geringe (grün), mittlere (gelb) und hohe (rot) Risiken.

Entsprechend unserer Methode zur Risikobewertung werden nur die hohen Risiken als wesentlich eingestuft.

			Eintrittswahrscheinlichkeit				
			sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
			> 0% bis ≤ 5%	> 5% bis ≤ 10%	> 10% bis ≤ 25%	> 25% bis ≤ 50%	> 50% bis ≤ 100%
Auswirkung	bestandsgefährdend	> 10 Mio. € bis ≤ 20 Mio. €	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
	schwerwiegend	> 2 Mio. € bis ≤ 10 Mio. €	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
	bedeutend	> 500 Tsd. € bis ≤ 2 Mio. €	mittel	hoch	hoch	hoch	hoch
	moderat	> 20 Tsd. € bis ≤ 500 Tsd. €	gering	mittel	hoch	hoch	hoch
	vertretbar	0 € bis ≤ 20 Tsd. €	gering	gering	mittel	hoch	hoch

gering
 mittel
 hoch

Risikohandhabung

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess gemäß § 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB

Das Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das Risiko der Falschaussage in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen Berichterstattung zu minimieren. Es dient im ersten Schritt der Identifikation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung und Überprüfung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungsprozess, die dem Ziel der Regelungskonformität des Konzernabschlusses entgegenstehen könnten. Das interne Kontrollsystem des Rechnungslegungsprozesses soll gewährleisten, dass trotz identifizierter Risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichender Sicherheit regelkonformer Konzernabschluss erstellt wird.

Die Angemessenheit des Risikofrüherkennungssystems wird im Rahmen der Abschlussprüfung zum Jahresende durch den Abschlussprüfer überprüft. Weiterhin werden ausgewählte rechnungslegungsbezogene interne Kontrollen untersucht und deren Effektivität beurteilt. Darüber hinaus werden ausgewählte Aspekte der eingesetzten IT-Systeme geprüft.

Die Verantwortung für die Einrichtung und wirksame Unterhaltung angemessener Kontrollen über die Finanzberichterstattung liegt beim Management der SÜSS MicroTec SE, das zu jedem Geschäftsjahresende die Angemessenheit und Wirksamkeit des Kontrollsystems beurteilt. Zum 31. Dezember 2017 hat das Management die Wirksamkeit der internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung festgestellt. Selbstverständlich bestehen bei jedem Kontrollsystem gewisse Einschränkungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit. Eine absolute Sicherheit kann auch mit angemessenen und funktionsfähigen Systemen nicht gewährleistet werden.

Die SÜSS MicroTec SE nutzt ihr konzernweit gültiges Bilanzierungshandbuch zur einheitlichen Regelung von Bilanzierungs-

grundsätzen. Das Bilanzierungshandbuch basiert auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards und wird von allen Konzerngesellschaften beim Rechnungslegungsprozess zugrunde gelegt. Durch eindeutige Vorgaben soll der Ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten und Schulden eingeschränkt und somit das Risiko konzernuneinheitlicher Rechnungslegungspraktiken verringert werden. Den Tochtergesellschaften sind bestimmte Berichtspflichten und -umfänge zwingend vorgegeben. Die Einhaltung der Berichtspflichten und -fristen wird durch die zentralen Abteilungen Finanzen und Controlling überwacht.

Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstützung von externen Buchführungsfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche EDV-Systeme eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften arbeiten bereits seit 2008 mit SAP. Seit 2010 wird SAP bei der SÜSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsinchu, Taiwan, verwendet. 2011 wurde SAP bei der SÜSS MicroTec, Inc., Corona, Kalifornien, USA, implementiert. 2015 wurde die SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc., Kalifornien, USA, an das konzernweite SAP-System angeschlossen. Das Reporting an die Konzernzentrale erfolgt mit Hilfe der Managementinformationssysteme „INFOR PM Application Studio“. Die Einzelabschlüsse werden über ein zentrales Konsolidierungssystem zusammengeführt. Auf Konzernebene werden innerhalb der Finanzabteilung und des Controllings die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der von den Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlüsse überprüft. Kontrollen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie beispielsweise der Schulden- oder der Aufwands- und Ertragskonsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mängel werden korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurückberichtet. Die eingesetzten Finanzsysteme sind durch entsprechende Berechtigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch geschützt. Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

RISIKEN DES KONZERNS

Gesamtwirtschaftliche Risiken

SÜSS MicroTec ist weltweit vertreten, weist eine breite Kundenstruktur auf und bietet seinen Kunden sieben unterschiedliche Produktlinien an, die in verschiedenen Branchen und Industriezweigen eingesetzt werden können. Damit ist SÜSS MicroTec grundsätzlich weder von einzelnen Märkten noch von einzelnen Abnehmern abhängig. Konjunkturelle Einbrüche in einer Region oder Branche können somit zumindest teilweise aufgefangen werden. Dank der flexiblen Aufstellung ist SÜSS MicroTec bei größeren konjunkturellen Verwerfungen in der Lage, unverzüglich auf die Marktgegebenheiten zu reagieren und die Kostenstrukturen in angemessener Zeit anzupassen. Als Instrumente stehen Gleitzeitkonten, der Einsatz von Zeitarbeitskräften sowie Outsourcing-Maßnahmen zur Verfügung. Darüber hinaus besteht die Option, Kurzarbeit zu beantragen. Zudem werden von den Einkaufsabteilungen regelmäßig die Beschaffungsmengen überprüft und angepasst.

Politische Entscheidungen, neue Gesetzgebungen und sonstige Regularien in den Ländern, in denen SÜSS MicroTec tätig ist, können unser Geschäft negativ beeinflussen. Dazu gehören die Steuergesetzgebung in den jeweiligen Ländern, Exportbeschränkungen sowie Verschärfungen in den Bereichen Produkthaftung, Wettbewerbsrecht, Arbeitssicherheit sowie Patent- und Markenrecht.

SÜSS MicroTec nimmt regelmäßig an öffentlichen Ausschreibungen teil und zählt auch Universitäten und staatliche Forschungseinrichtungen weltweit zu seinen Kunden. Die Regelungen für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen und die Kriterien für die Vergabe unterscheiden sich je nach Land und können das Gewinnen von öffentlichen Aufträgen und deren Abwicklung deutlich erschweren.

Generell können starke Veränderungen am Währungsmarkt den Absatz und das Unternehmensergebnis von SÜSS MicroTec sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Die Wertveränderungen des Euro insbesondere im Vergleich zum US-Dollar oder japanischen Yen werden künftig den Absatz und die erzielbaren Margen im nordamerikanischen und asiatischen Raum beeinflussen. Eine Aufwertung des Euro im Vergleich zum US-Dollar oder japanischen Yen würde sich eher negativ auswirken, während eine Abwertung voraussichtlich positive Effekte für SÜSS MicroTec nach sich ziehen würde.

Der Kurs des Schweizer Frankens hat keine spürbaren Auswirkungen auf das Bestellverhalten unserer Kunden in den Segmenten Lithografie, Bonder oder Fotomaschinen-Equipment. Allerdings ist das Geschäft der SÜSS MicroOptics S.A., die in Hauterive, Schweiz, angesiedelt ist und Mikrolinsen herstellt, vom Wechselkurs des Schweizer Frankens beeinflusst. Ein im Vergleich zum Euro oder US-Dollar stark aufgewerteter Schweizer Franken könnte das MicroOptics-Geschäft negativ beeinflussen.

Der SÜSS MicroTec-Konzern wickelt nur in sehr geringem Umfang Geschäfte in asiatischen Währungen (taiwanesischer Dollar, Singapur-Dollar, südkoreanischer Won und chinesischer Renminbi) ab. Die in Taiwan, Singapur, Südkorea und China ansässigen Tochtergesellschaften des Konzerns weisen jedoch in Euro dotierte Forderungen gegen Kunden und andere SÜSS MicroTec-Gesellschaften aus. Je nach Umfang und Fälligkeit können aus der Bewertung dieser Forderungen in der jeweiligen Landeswährung signifikante Währungsverluste im Konzern entstehen.

Branchen- und marktspezifische Risiken

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken für SÜSS MicroTec. Insbesondere die Halbleiterindustrie, die zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen geprägt. Ein signifikanter Einbruch des gesamten Halbleitermarktes würde bei SÜSS MicroTec Umsatzrückgänge nach sich ziehen und das Unternehmensergebnis schmälern. Den damit verbundenen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls durch Outsourcing ergänzt werden können.

Mitarbeiterspezifische Risiken

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird. Darüber hinaus könnten sich fehlende oder nicht ausreichend qualifizierte Mitarbeiter in der Produktion negativ auf die Qualität auswirken.

Entwicklungsspezifische Risiken

Das Geschäftsmodell der SÜSS MicroTec-Gruppe basiert auf seiner starken Innovationskultur und Technologieführerschaft. Als Hersteller von Spezialmaschinen liefert SÜSS MicroTec kundenspezifische Lösungen und richtet seine Produktpolitik nach den sich schnell verändernden Bedingungen im Halbleiter-Equipment-Markt. Trotzdem sehen wir das Risiko, dass in Einzelfällen unsere technischen Entwicklungen die Vorstellungen der Märkte und unserer Kunden verfehlen könnten. In diesen Fällen bestünde die Gefahr, dass sich die betroffenen Kunden von SÜSS MicroTec abwenden und alternative technische Lösungen bei unseren Konkurrenten suchen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben unsere Ingenieure für alle Produktlinien neue Technologien entwickelt und zahlreiche Detailverbesserungen an bestehenden Technologien vorgenommen. Von unseren Kunden haben wir hierzu sehr positive Reaktionen erhalten, die sich im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits in Form von erhöhten Auftragseingängen gezeigt haben.

Neben der Ausarbeitung von kundenspezifischen Lösungen arbeiten die Ingenieure der SÜSS MicroTec-Gruppe permanent an langfristigen Entwicklungsprojekten, die zukünftige Entwicklungen der Märkte antizipieren sollen, damit die Produkte von SÜSS MicroTec auch in Zukunft aktuelle technische Anforderungen erfüllen werden. Es besteht das Risiko, dass einzelne Entwicklungsprojekte nicht zum gewünschten Ergebnis führen oder das erzielte Ergebnis nicht die Erwartungen der Märkte trifft. In diesen Fällen bestünde die Gefahr, dass SÜSS MicroTec auf dem angestrebten Markt zeitweise nicht mit innovativen Produkten vertreten wäre. Die betroffenen Kunden könnten sich von SÜSS MicroTec abwenden und Alternativen am Markt suchen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir uns auf Projekte konzentriert, von denen wir glauben, dass sie bei unseren Kunden auf positive Resonanz stoßen werden. Ein besonderer Fokus lag dabei auf dem Projekt, das für die Weiterentwicklung des Projektionsscanners DSC300 ins Leben gerufen wurde. Die bisher sehr überzeugenden Testergebnisse und die positiven Reaktionen unserer Kunden stimmen uns zuversichtlich, dass die Markteinführung der nächsten Produktgeneration, die für das zweite Quartal 2018 angestrebt wird, erfolgreich sein wird. Sollte – entgegen unserer Erwartung – die Resonanz unserer Kunden jedoch nicht positiv sein und es uns nicht gelingen, in einem überschaubaren Zeitraum neue Aufträge für die DSC300 Gen3 zu gewinnen, hätte SÜSS MicroTec knappe Ressourcen im Bereich Entwicklung ungünstig eingesetzt. Dies würde sich entsprechend negativ auf das Ergebnis der Produktlinie UV-Projektionsscanner auswirken. Insgesamt ist dieses Risiko nicht als bestandsgefährdend für SÜSS MicroTec anzusehen.

Für einige unserer Produkte sehen wir uns als Marktführer, da wir mit technologisch hochwertigen Lösungen die Anforderungen unserer Kunden passgenau erfüllen. Um diese Marktführerschaft und die Zufriedenheit unserer Kunden zu erhalten, sind laufend Neuentwicklungen und Verbesserungen an unseren bestehenden Produkten erforderlich. Es besteht das Risiko, dass technische Neuentwicklungen von uns nicht rechtzeitig erkannt oder umgesetzt werden. In diesen Fällen sehen wir die Gefahr, dass SÜSS MicroTec seine Marktführerschaft in einzelnen Bereichen verlieren könnte und auf lange Sicht Umsatzeinbußen hinnehmen müsste.

Operative Risiken

Angesichts des hohen Bestands an flüssigen Mitteln, der hohen Eigenkapitalquote und der schlanken Kostenstruktur sind die Risiken, die sich für SÜSS MicroTec aus der aktuellen Vermögens- und Ertragslage ergeben könnten, begrenzt. Mit einem EBIT von 13,9 Mio. € hat der SÜSS MicroTec-Konzern 2017 zudem ein deutlich positives Ergebnis erzielt. Unter Berücksichtigung des zum Jahresende 2017 vorhandenen Auftragsbestands und der erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste Halbjahr 2018 gehen wir davon aus, 2018 einen Umsatz in der Bandbreite von 195 Mio. € bis 205 Mio. € und ein positives EBIT zwischen 8,5 Prozent und 10,0 Prozent vom Umsatz zu erzielen.

Zum 31. Dezember 2017 weist SÜSS MicroTec einen Goodwill in Höhe von rund 15,6 Mio. € aus, der ausschließlich dem Segment Lithografie zuzuordnen ist. Das Segment Lithografie erwirtschaftet rund zwei Drittel des Konzernumsatzes und ein positives Segmentergebnis. Das Segment Lithografie wird auch im nächsten Jahr mehr als die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes erwirtschaften und wird weiterhin profitabel sein. Für Wertminderungen im Segment Lithografie sehen wir daher keine Anzeichen.

Die Produktlinie Mask-Aligner, die zum Segment Lithografie gehört, ist eine der umsatzstarken Produktlinien der SÜSS MicroTec-Gruppe und leistet seit vielen Jahren einen hohen Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis. Wir gehen fest davon aus, dass diese Produktlinie auch in den kommenden Jahren einen hohen Umsatzbeitrag und stabile Margen erzielen wird. Trotzdem besteht das Risiko, dass der Mask-Aligner zukünftig die technischen Anforderungen der Kunden nicht mehr erfüllen und von anderen Technologien verdrängt werden könnte. Dieses Risiko sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt jedoch als gering an. Zudem kann SÜSS MicroTec seinen Kunden mit den in den USA angesiedelten Produktlinien, den Laser- und Scannersystemen, alternative Lösungen anbieten.

Auch die Produktlinie Belacker, die ebenfalls zum Segment Lithografie gehört, leistet seit vielen Jahren einen hohen Umsatz- und Ergebnisbeitrag im Konzern. Insbesondere im Geschäftsjahr 2016 konnten mit den Belackern und Entwicklern außergewöhnlich hohe Margen erzielt werden. In 2017 erzielte SÜSS MicroTec mit Belackern und Entwicklern weiterhin stabile Umsätze und konnte hohe Auftragseingänge verzeichnen. Die Rohertragsmarge der Belacker/Entwickler, für die Umsatz realisiert wurde, hat sich jedoch auf einem niedrigeren Niveau (verglichen mit dem Vorjahr) eingependelt. Das Geschäftsjahr 2017 hat erneut gezeigt,

dass wir technologisch weiterhin eine führende Position einnehmen und uns gegenüber japanischen und chinesischen Wettbewerbern am Markt für Belacker gut behaupten können. Für die Zukunft gehen wir von weiter hohen Auftragsvolumina und Umsätzen sowie angemessenen Margen aus. Das Risiko, Marktanteile an asiatische Wettbewerber zu verlieren, sehen wir als gering an.

Im Segment Lithografie sind auch die Produktlinien der SÜSS MicroTec Photonic Systems für UV-Projektionsbelichtung und Laserprozessierung erfasst. Nachdem im Jahr 2016 der Umsatz für einen Großauftrag mit UV-Projektionsscannern realisiert werden konnte, hat SÜSS MicroTec in 2017 mit beiden Produktlinien nur geringe Umsätze erzielt. Nach der in 2016 erfolgreichen Produkt- und Technologiequalifizierung bei einem führenden Hersteller der Halbleiterindustrie konnten in 2017 nur in sehr geringem Umfang Aufträge von neuen Kunden für den UV-Projektionsscanner aus dem Bereich Photonic Systems gewonnen werden. Der Auftragseingang für die Produktlinie Laserprozessierung entwickelte sich ebenfalls sehr verhalten. Insgesamt haben die Produktlinien der SÜSS MicroTec Photonic Systems in 2017 erneut ein deutlich negatives Ergebnis zum Konzernergebnis beigesteuert. Auch in 2018 werden die Photonic-Systems-Produktlinien planmäßig geringe Umsätze und ein negatives Ergebnis erzielen. Um die Wettbewerbsfähigkeit der UV-Projektionsbelichtungssysteme weiter zu steigern, wurde in 2016 ein Projekt ins Leben gerufen, das die Entwicklung einer neuen Plattform der DSC300 Gen3 zum Inhalt hat. Ziel der Neuentwicklung ist ein deutlich gesteigerter Durchsatz bei gleichzeitig verbessertem Overlay. Aufgrund der bisher sehr überzeugenden Testergebnisse und der äußerst positiven Rückmeldungen unserer Kunden gehen wir davon aus, dass die Markteinführung der neuen Produktgeneration, die für das zweite Quartal 2018 geplant ist, erfolgreich sein wird. Trotzdem besteht das Risiko, dass Bestellungen von Kunden sich verzögern oder möglicherweise ganz ausbleiben. Nach unserer Einschätzung kann ein positiver Ergebnisbeitrag mit den Photonic-Systems-Produktlinien nur erreicht werden, wenn das beschriebene Entwicklungsprojekt zum gewünschten Ergebnis führt und es uns damit gelingt, weitere Kunden von unseren Systemen zu überzeugen. Sollte es SÜSS MicroTec nicht gelingen, mit den Laser- und Scannersystemen substanzielle Umsätze und positive Margen zu erzielen, würden dadurch das Ergebnis des Segments Lithografie und das Konzernergebnis sowie die Liquiditätsslage weiterhin negativ beeinflusst werden.

Zudem könnte sich im Einzelabschluss der SÜSS MicroTec SE zusätzlicher Wertberichtigungsbedarf auf die Ausleihungen an die SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. sowie auf den Beteiligungsansatz der SÜSS MicroTec, Inc. – als finanzierender Gesellschaft der SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. – ergeben, sofern die in den USA gefertigten Produktlinien dauerhaft ein negatives Ergebnis erzielen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Segment Bonder erstmals ein positives EBIT von 3,3 Mio. € erzielt (nach -1,7 Mio. € im Vorjahr). Wir gehen davon aus, dass von nun an das Segment Bonder mit Produktlinien im Bereich permanentes Bonden und temporäres Bonden konstant einen positiven Ergebnisbeitrag

zum Konzernergebnis leisten wird. Beide Bereiche des Segments – sowohl das permanente Bonden als auch das temporäre Bonden – haben im Geschäftsjahr 2017 den geplanten Umsatz erzielen können und ein deutlich positives EBIT erreicht. Inzwischen sehen wir unsere Marktposition als sehr gefestigt an. Mit den Permanent-Bondern, den Mask-Alignern und den Belackern/Entwicklern können wir unseren Kunden ein komplettes und aufeinander abgestimmtes Produktportfolio anbieten und so insbesondere Forschungsinstitute und Universitäten zufriedenstellen, die diese drei Produktlinien in der Regel von einem Anbieter beziehen möchten. Die Umsatzentwicklung des Bereichs Temporary Bonding hat sich ebenfalls erfreulich entwickelt, sodass wir auch hier für die Zukunft von höheren Stückzahlen und nachhaltig positiven Margen ausgehen.

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert. Die Angemessenheit dieser Versicherungen, in deren Schutz auch die Konzerngesellschaften einbezogen sind, wird regelmäßig hinsichtlich der abgedeckten Risiken und Deckungssummen überprüft und bei Bedarf angepasst. Darüber hinaus bemühen wir uns, mit allen Vertragspartnern Haftungsbeschränkungen in den Verträgen zu vereinbaren.

Risiken der Informationstechnologie

Grundsätzlich sehen wir unsere IT-Infrastruktur als gut ausgebaut an und sind der Meinung, dass wir ausreichend Vorkehrungen getroffen haben, um Datenmanipulationen, Datenverluste oder Datenmissbrauch zu vermeiden. Zudem investieren wir regelmäßig in neue Hard- und Software, um den Ausfall von IT-Systemen und Softwarelösungen möglichst gering zu halten. Mit Virenschannern und Virenschutzprogrammen, die laufend auf dem aktuellen Stand gehalten werden, schützen wir unsere IT-Systeme vor Zugriffen und Beschädigungen von außen. Trotzdem können wir nicht ausschließen, dass es in einzelnen Fällen zu Datenmanipulationen, Datenverlusten oder Datenmissbrauch kommen könnte. Es ist auch denkbar, dass neue Viren oder Trojaner, die von unseren Sicherheitsprogrammen nicht erkannt werden, in unsere IT-Systeme eindringen könnten. Verschärft wird das Problem durch die zunehmende Nutzung von mobilen Endgeräten wie Notebooks oder Smartphones, die auf unser Firmennetzwerk zugreifen. Um das Risiko fremder Zugriffe auf unser Firmennetz-

werk, das sich durch die Nutzung von mobilen Endgeräten ergibt, möglichst gering zu halten, ist eine konzernweit geltende Richtlinie in Kraft, die den Umgang mit mobilen Endgeräten regelt.

FINANZIELLE RISIKEN

Kreditrisiken

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust von Zahlungsmitteln oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richtlinie zum Thema „Credit Assessment“ implementiert. Diese Richtlinie legt für die einzelnen Vertriebsseinheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezifischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in sogenannten Risk-Countries angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen Zahlung des gesamten Auftragswerts, eine Bankgarantie oder einen Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden, die in sogenannten Non-Risk-Countries ansässig sind und eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 20,5 Mio. € (Vorjahr: 24,5 Mio. €) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 13,1 Mio. € (Vorjahr: 20,5 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2017 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar:

ALTERSANALYSE DER ÜBERFÄLLIGEN FORDERUNGEN OHNE WERTBERICHTIGUNG

in Tsd. €	2017	2016
1–30 Tage	3.741	2.272
31–60 Tage	238	447
61–90 Tage	1.012	549
91–180 Tage	0	10
Überfällige Forderungen ohne Wertberichtigung	4.991	3.278

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 2,4 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt.

Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestellt:

ALTERSANALYSE DER ÜBERFÄLLIGEN FORDERUNGEN MIT WERTBERICHTIGUNGEN

in Tsd. €	2017	2016
< 91 Tage	0	0
91–180 Tage	1.636	228
181–360 Tage	544	388
> 360 Tage	203	147
Überfällige Forderungen mit Wertberichtigung	2.383	763

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

Liquiditätsrisiken

Zum Jahresende weist der SÜSS MicroTec-Konzern einen Net-Cash-Bestand von 33,0 Mio. € aus (Vorjahr: 31,1 Mio. €). Der Free Cashflow (bereinigt um Effekte aus Wertpapiererwerben und Wertpapierverkäufen) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 2,9 Mio. € (Vorjahr: -9,1 Mio. €).

Zwischen der SÜSS MicroTec SE und der IKB Deutsche Industriebank AG besteht ein Darlehensvertrag, der der Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Garching dient. Das Darlehen belief sich ursprünglich auf 7,5 Mio. €. Es wurde am 16. Dezember 2013 valutiert und zur Auszahlung gebracht und weist eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021 auf. Zum 31. Dezember 2017 weist der SÜSS MicroTec-Konzern für dieses Darlehen Bankverbindlichkeiten von 3,5 Mio. € aus. Die Tilgung für das Darlehen wird sich bis zum 30. Juni 2021 auf 1,0 Mio. € pro Jahr belaufen. Zudem fallen für das Darlehen bankübliche Zinsen an.

Dem SÜSS MicroTec-Konzern standen zum 31.12.2017 insgesamt Kredit- und Avallinien von 8,25 Mio. € bei nationalen und internationalen Bankinstituten zur Verfügung. Drei Banken stellen der SÜSS MicroTec Lithography GmbH über bilaterale Verträge Kredit- und Avallinien von insgesamt 4,5 Mio. €. Diese Kredit- und Avallinien werden bis auf weiteres gewährt. In 2017 wurden der SÜSS MicroTec Lithography GmbH darüber hinaus zusätzliche Avallinien von 3,0 Mio. € bereitgestellt. Diese zusätzlichen Linien waren befristet bis zum 31.12.2017. Eine weitere Kreditlinie in Höhe von 0,75 Mio. € steht der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG zur Verfügung. Die verfügbaren Kredit- und Avallinien nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen Geschäft zu stellen. Zum 31. Dezember 2017 sind diese Kredit- und Avallinien in Höhe von 3,4 Mio. € in Form von Avalen in Anspruch genommen. Wir gehen davon aus, dass wir auch zukünftig alle erforderlichen Anzahlungsbürgschaften stellen können.

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (23) des Konzernanhangs.

Marktpreisrisiken

Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Änderungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsalternativen.

SÜSS MicroTec ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgrund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Die Währungssicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Sicherungsquote rund 65 Prozent bzw. 45 Prozent. Gegenläufige Zahlungsströme, die sich insbesondere aus Fremdwährungsbestellungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ergeben, werden von dem so ermittelten zu sichernden Fremdwährungsbetrag abgesetzt. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (28).

Eine günstige Entwicklung der Fremdwährungskurse kann zu höheren Margen einzelner Aufträge führen und zusätzliche Kursgewinne generieren.

Ein Zinsänderungsrisiko für den SÜSS MicroTec Konzern ist nicht erkennbar. Das Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Garching ist mit einem fixen Zinssatz belegt.

GESAMTEINSCHÄTZUNG

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2017 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet.

Die für den SÜSS MicroTec-Konzern wesentlichen Risiken sind in der folgenden Tabelle im Überblick dargestellt. Die Risiken wurden dabei nach der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie nach den möglichen finanziellen Auswirkungen (gemessen an der Höhe des möglichen Liquiditätsabflusses) bewertet.

	Eintrittswahrscheinlichkeit					Auswirkung				
	sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch	vertretbar	moderat	bedeutend	schwerwiegend	bestandsgefährdend
	> 0 % bis ≤ 5 %	> 5 % bis ≤ 10 %	> 10 % bis ≤ 25 %	> 25 % bis ≤ 50 %	> 50 % bis ≤ 100 %	0 € bis ≤ 20 Tsd. €	> 20 Tsd. € bis ≤ 500 Tsd. €	> 500 Tsd. € bis ≤ 2 Mio. €	> 2 Mio. € bis ≤ 10 Mio. €	> 10 Mio. € bis ≤ 20 Mio. €
Gesamtwirtschaftliche Risiken										
Negative Auswirkungen durch Wechselkursschwankungen			X					X		
Entwicklungsspezifische Risiken										
Produktpolitik, Kundenzufriedenheit			X						X	
Ungenügende Innovationsfähigkeit, verfehlte Entwicklungsprojekte			X						X	
Verlust der Marktführerschaft in einzelnen Bereichen			X						X	
Operative Risiken										
Umsatzeinbußen bei Mask-Alignern	X							X		
Verlust von Marktanteilen der Belacker ¹			X					X		
Keine Profitabilität von UV-Projektionsbelichtung und Laserprozessierung ²			X						X	
Permanentes Bonden – Marktanteil kann nicht ausgebaut werden ¹			X					X		
Temporäres Bonden – die von SÜSS MicroTec entwickelte Technologie setzt sich am Markt nicht durch ¹		X						X		
Produkthaftung	X							X		
IT-Risiken										
Datensicherheit			X				X			

¹ Eintrittswahrscheinlichkeit Vorjahr: mittel.

² Eintrittswahrscheinlichkeit Vorjahr: hoch.

PROGNOSEBERICHT

Das Geschäftsumfeld von SÜSS MicroTec wird durch die regionalen wie auch die weltweiten konjunkturellen Bedingungen sowie Branchenentwicklungen beeinflusst. In dem nachfolgenden Prognosebericht gehen wir auf die verschiedenen Faktoren ein, die das Unternehmen ebenso wie führende Markt- und Branchenbeobachter als maßgeblich für die weitere Geschäftsentwicklung ansehen.

Die Weltwirtschaft befindet sich weiterhin in einem deutlichen Aufwärtstrend. Nach einem Zuwachs von 3,3 Prozent im Jahr 2017 dürfte die Weltwirtschaft gemäß einer Studie des ifo Instituts München im Jahr 2018 erneut um 3,3 Prozent zulegen. Im Folgejahr wird sich das Wachstum erwartungsgemäß leicht abschwächen und einen Zuwachs von 3,0 Prozent erreichen. Die US-Wirtschaft wuchs nach Prognosen des Internationalen Währungsfonds im abgelaufenen Jahr um 2,2 Prozent. Dieser Wert könnte sich nicht zuletzt durch die Ende 2017 verabschiedete Steuerreform erhöhen. Das Wirtschaftswachstum in China erwies sich robuster als erwartet. Bereits in den ersten drei Quartalen 2017 wuchs die chinesische Wirtschaft mit 6,9 Prozent stärker, als bisher prognostiziert worden war. Auf Jahressicht soll das Wachstum laut Prognosen der Weltbank 6,8 Prozent betragen. Dazu tragen hauptsächlich die starken Exporte sowie ein von staatlicher Seite unterstützter Bauboom bei. Der IWF warnte allerdings davor, dass das kräftige Wachstum nur durch höhere Schulden erkauft sei. Tatsächlich versucht die chinesische Regierung die Kreditvergabe zu zügeln. Dadurch könnte das Wachstum in 2018 geringer ausfallen als noch in 2017.

Auch in Deutschland und Europa standen die Zeichen 2017 auf Wachstum. Dabei wirkte die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank weiterhin unterstützend. In den meisten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wird im Geschäftsjahr 2017 mit einer wachsenden Wirtschaft gerechnet, selbst in den ehemaligen Krisenländern Spanien, Portugal und Griechenland. Beispielsweise betrug das Wachstum in Spanien letztes Jahr nach Angaben des Wirtschaftsministeriums 3,1 Prozent. Auch Frankreich wuchs mit prognostizierten 1,9 Prozent im vergangenen Jahr so stark wie seit sechs Jahren nicht mehr. Zusätzlich schürt die wirtschaftsfreundliche Arbeitsmarktreform von Präsident Emmanuel Macron, die ab Januar 2018 in Kraft treten soll, Hoffnungen auf eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung Frankreichs. In Großbritannien leidet die Wirtschaft bereits unter dem Ende März 2017 offiziell deklarierten EU-Ausstieg und den damit verbundenen Unsicherheiten. Zwar wuchs die britische Wirtschaft laut Prognosen der EU-Handelskommission 2017 um 1,5 Prozent, jedoch soll das Wachstum 2018 und 2019 mit 1,4 Prozent und 1,1 Prozent deutlich schwächer ausfallen als im Rest Europas (Quelle: HSBC Jahresrückblick 2017). Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone

betrug gemäß den Schätzungen des ifo Instituts München rund 2,4 Prozent, für das laufende Geschäftsjahr wird ein erneuter Zuwachs um 2,5 Prozent prognostiziert, bevor im Jahr 2019 die Dynamik etwas abnimmt und das Wachstum auf rund 2,0 Prozent zurückgehen könnte.

Für Deutschland wird ein Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts von 2,6 Prozent im Jahr 2018 erwartet. Im Vorjahr lag der Zuwachs erwartungsgemäß noch bei 2,3 Prozent. Die Gründe für das anhaltende Wachstum liegen vor allem in der guten Binnennachfrage, getragen durch den privaten Konsum, sowie der hohen Nachfrage nach deutschen Produkten aus dem Ausland.

BRANCHENSPEZIFISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

HALBLEITERINDUSTRIE

Das Geschäftsjahr 2017 war ein sehr starkes Jahr für die gesamte Halbleiterbranche. Gemäß den Erwartungen verschiedener Marktforschungsinstitute wird für das Jahr 2018 erneut ein deutliches Marktwachstum prognostiziert. Der gesamte Halbleitermarkt erreichte 2017 ein Volumen von rund 419 Mrd USD. Für 2018 gehen die Experten von Gartner in ihren Schätzungen vom Januar 2018 davon aus, dass ein neues Rekordniveau von rund 451 Mrd. USD erreicht werden kann. Dies entspricht einem Zuwachs von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch in den kommenden Quartalen dürften die Nachfrage und die hohen Preise von Speichermedien das Wachstum im Halbleitersegment beflügeln. Begrenzte Produktionskapazitäten und leere Lagerräume trieben die Preise für DRAM- und NAND-Speichermedien bereits 2017 deutlich in die Höhe. Die hohen Preise werden voraussichtlich einen negativen Einfluss auf die Margen der Hersteller von elektronischen Endgeräten wie Smartphones und Computern oder Servern haben.

Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist die Prognosegenauigkeit aufgrund der Besonderheiten und der ausgeprägten Zyklizität im Halbleiterbereich sehr begrenzt. Vor diesem Hintergrund stellen die Ausführungen Einschätzungen dar, die auf Basis der zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden, aber keine Garantie für das tatsächliche Eintreten der Prognosen bieten.

HALBLEITER-EQUIPMENT-INDUSTRIE

Die ursprünglichen Schätzungen für den Bereich Halbleiter-Equipment des Branchenverbands SEMI für das Geschäftsjahr 2017 wurden von den vorläufigen Zahlen für 2017 weit übertroffen. Der Markt für Halbleiter-Equipment wuchs um etwa 41 Prozent gegenüber 2016 und erreichte damit ein Gesamtvolumen von rund 57 Mrd. USD. Für das Jahr 2018 wird erneut ein starkes Wachstum prognostiziert. So soll gemäß den SEMI-Schätzungen vom Januar 2018 der Markt für Halbleiter-Equipment um rund 11 Prozent auf ein Volumen von rund 63 Mrd. USD wachsen. Insbesondere Investitionen aus Korea, Taiwan und erstmals auch ein zweistelliges Milliarden-Investitionsvolumen aus China werden den Markt bewegen. Auch hier treiben die hohe Nachfrage und die hohen Preise für Speichermedien das Marktvolumen. Endanwendungen für die Speichermedien sind beispielsweise Server oder Cloud-Anwendungen, Smartphones, das Internet der Dinge sowie die zunehmende Vernetzung und Digitalisierung des täglichen Lebens. Gemäß den Schätzungen der IDC (International Data Corporation) werden sich allein die Ausgaben rund um das Internet der Dinge von etwa 674 Mrd. USD im Jahr 2017 auf ca. 773 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2018 erhöhen.

Für das Mid- und Backend der Halbleiterindustrie, den Hauptabsatzmarkt für SÜSS MicroTec-Maschinen, erwartet Gartner für 2018 in seinen Schätzungen vom August 2017 kaum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere der Bereich Wafer-Fab-Equipment inklusive Wafer-Level-Packaging wird sich auf einem hohen Niveau stabilisieren und um rund 0,1 Prozent gegenüber 2017 (Vorjahr: plus 17,9 Prozent) wachsen. Auch für diese Prognosen gilt die Aussage, dass die Erwartungen der Marktforschungsinstitute sich im Zeitablauf häufig deutlich verändern und gesicherte Prognosen nicht möglich sind.

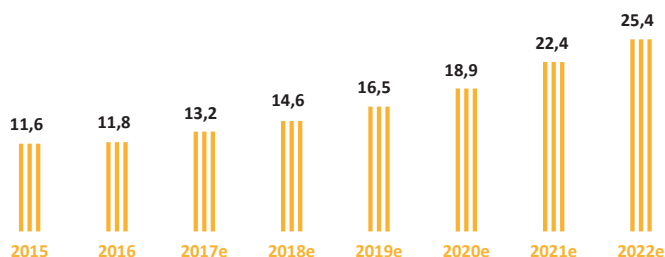
ERWARTETE ENTWICKLUNG IN DEN HAUPTMÄRKTEN

MIKROSYSTEMTECHNIK (MEMS)

Der Markt für Sensoren, insbesondere für mikroelektromechanische Systeme (MEMS), entwickelte sich im abgelaufenen Jahr weiterhin sehr dynamisch. Marktvolumen konnte gemäß Schätzungen von Yole Développement von rund 11,8 Mrd. USD um 12 Prozent auf 13,2 Mrd. USD zulegen. Für 2018 wird ein weiterer Zuwachs um 11 Prozent gegenüber Vorjahr erwartet. In den Jahren 2016 bis 2022 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 14,0 Prozent für MEMS-Sensoren (Stückzahl) erwartet. Für die Equipment-Branche ist zudem zu berücksichtigen, dass durch Effizienzgewinne, Durchsatz- und Yield-Erhöhungen sowie durch den Trend zu größeren Wafer-Durchmessern das Wachstum im Maschinenbereich erheblich geringer ausfallen wird.

Der MEMS-Markt ist durch ganz unterschiedliche Produktdesigns, Herstellungsverfahren und Endanwendungen geprägt. Gerade im Bereich Sensorik und bei den Aktuatoren gilt es, unterschiedlichste Anforderungen der entsprechenden Endanwendungen, wie beispielsweise Schutz gegen Feuchtigkeit oder Schmutz, Temperatur- und Druckunterschiede sowie die Vorgabe bestimmter Formfaktoren, zu erfüllen. Insbesondere das MEMS-Packaging wird hier vor große Herausforderungen gestellt. Im Hinblick auf die Endanwendungen wird sich der größte Bereich, die Konsumelektronik, neben den Bereichen Automotive und Sicherheitsanwendungen weiterhin sehr dynamisch entwickeln. Hier spielt der Übergang von 4G- zu 5G-Mobilfunknetzen eine wichtige Rolle. Frequenzfilter (RF, Radio-Frequency) werden aufgrund der zunehmenden Komplexität bei einem Wechsel von 4G auf 5G ein wichtiger Wachstumstreiber in diesem Markt sein. Das Packaging der MEMS-Bauelemente wird derzeit zu 55 Prozent bei OSATs (Outsourced-Assembly-and-Test-Unternehmen) sowie zu 45 Prozent bei den IDMs (Integrated-Device-Manufacturers) vorgenommen. SÜSS MicroTec zählt die MEMS-Hersteller selbst sowie OSATs und IDMs zu seinem Kundenstamm.

MARKT FÜR MEMS in Mrd. USD



ADVANCED PACKAGING UND 3D-INTEGRATION

Unter dem Begriff Advanced Packaging subsumiert man heute verschiedene Technologien wie beispielsweise das Wafer-Level-Packaging (WLP), bei dem die jeweilige Kontaktierung bereits stattfindet, während die einzelnen Chips sich noch auf dem Wafer befinden. Dazu gibt es die Unterformen Fan-in- und Fan-out-WLP, Flip-Chip-Bonding, Wafer-Level-Chip-Scale-Packaging sowie die 2,5D-Integration und die 3D-Integration. SÜSS MicroTec ist insbesondere mit seinen Lithografie- und Temporary-Bonding-Lösungen in diesem Feld aktiv.

Der für SÜSS MicroTec relevante Spezialbereich Wafer-Level-Packaging and -Assembly konnte laut SEMI im Geschäftsjahr 2017 um 25,8 Prozent auf 3,8 Mrd. USD zulegen. Im Vorjahr lag der Zuwachs noch bei rund 3,9 Prozent. Nach Schätzungen von Gartner lag das Wachstum für den Bereich Wafer-Fab-Equipment inklusive Wafer-Level-Packaging im Jahr 2017 bei 17,9 Prozent und erreichte damit ein Marktvolumen von 43,7 Mrd. USD. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Gartner eine Stabilisierung des Marktes auf dem hohen Niveau des Vorjahres, ein Zuwachs um 0,1 Prozent wird prognostiziert. Für das Geschäftsjahr 2019 könnte laut Gartner ein Rückgang des Marktvolumens um 7,3 Prozent anstehen.

Eine spezielle Form des Wafer-Level-Packaging (WLP) ist das sogenannte Fan-out-Wafer-Level-Packaging (FOWLP). Diese Technologie bietet unter anderem Vorteile bei der Verkleinerung von Formfaktoren der Packages, die beispielsweise in Smartphones zum Einsatz kommen. Yole erwartet für die Jahre 2018 bis 2022 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 20 Prozent in diesem speziellen Marktsegment, in dem SÜSS MicroTec mit seinen Lithografiegeräten – Belackern, Entwicklern, UV-Projektions-scannern – präsent ist.

Die 3D-Integration ist die weiterentwickelte Form der heute eingesetzten Advanced-Packaging-Technologien. Hierbei werden gedünnte Mikrochips übereinandergestapelt und durch TSVs (Thru-Silicon-Vias) miteinander verbunden. Die Vorteile sind eine große Packungsdichte und eine hohe Komplexität, die auf kleinstem Raum erreicht werden kann. Durch die 3D-Integration ist es

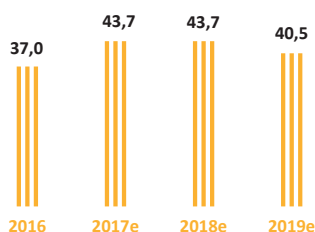
zudem möglich, verschiedene Funktionalitäten, wie beispielsweise Speicher und Prozessor, in einem Package zu vereinigen.

Nachdem SÜSS MicroTec im Lagebericht 2016 geschrieben hatte, dass der Einstieg in die Volumenproduktion weiterhin auf sich warten ließ, obwohl verschiedene große Halbleiterunternehmen verstärkte Aktivitäten in diesem Bereich aufwiesen, konnten im Geschäftsjahr 2017 erstmals Aufträge eines internationalen IDMs für den Einstieg in die Volumenfertigung im Speicherbereich verbucht werden. SÜSS MicroTec geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass zukünftig neben dem Lead-Kunden weitere Hersteller von Speichermedien verstärkt im Bereich 3D-Integration investieren werden. Gemäß Yole lag der Anteil von Speichermedien, die mittels 3D-Integration mit TSVs verarbeitet wurden, im Jahr 2016 bei unter einem Prozent. Dieser Anteil kann sich bis zum Jahr 2020 auf rund 8 Prozent erhöhen. Aus diesem Grund ist SÜSS MicroTec sehr zuversichtlich, dass die 3D-TSV-Technologie zukünftig maßgeblich zum Umsatz- und Ergebniswachstum des Konzerns beitragen wird.

VERBINDUNGSHALBLEITER (LED)

Der Markt für Verbindungshalbleiter spielt für SÜSS MicroTec eine eher untergeordnete Rolle. Nur die Jahre 2010 und 2011 stellten hierbei eine Ausnahme dar. Auch 2017 lag der Anteil am Gesamtumsatz erneut deutlich unter 10 Prozent und aus heutiger Sicht ist kein nennenswerter Anstieg dieses Anteils abzusehen.

MARKT FÜR WAFER-FAB-EQUIPMENT INKL. WAFER-LEVEL-PACKAGING in Mrd. USD



ENDOGENE INDIKATOREN

Neben der Entwicklung in den Zielmärkten ist für den Geschäftserfolg das Innovationspotenzial entscheidend. SÜSS MicroTec pflegte auch im Geschäftsjahr 2017 wichtige Entwicklungskooperationen mit namhaften Partnern aus Industrie und Forschung. Kooperationen mit renommierten Universitäten und Forschungsinstituten sowie technologiegetriebenen Unternehmen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Darüber hinaus führte das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr verschiedene Neuentwicklungen in den Markt ein.

In der ersten Jahreshälfte 2017 konnten wir dem Markt mit der XBS200 ein brandneues automatisches Gerät zum permanenten Bonden von Wafern vorstellen. Die XBS200 ist eine universelle Plattform, die für die Prozessierung von Wafern mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm geeignet ist. Die Vielseitigkeit und das modulare Design der XBS200 bieten maximale Prozessflexibilität für alle Anforderungen im Bereich des permanenten Bondens. Ein neues und innovatives Konzept zum Transfer justierter und gebondeter Waferpaare eliminiert die Komplexität herkömmlicher Systeme und ermöglicht konsistente Prozessergebnisse bei hervorragender Systemverfügbarkeit. Die XBS200-Plattform bietet niedrige Betriebskosten bei der Volumenproduktion von MEMS und LEDs sowie der 3D-Integration.

SÜSS MicroTec ist seit vielen Jahren der Marktführer für temporäre Bondlösungen für 3D-TSV-Integrationsprozesse. Bisher kam diese Technologie überwiegend bei der Fertigung von hochwertigen Kleinserien beziehungsweise im Laborumfeld der Halbleiterindustrie zum Einsatz. Durch die ständige Weiterentwicklung der Maschinen und die enge Kooperation mit unseren Kunden konnten im Geschäftsjahr 2017 erstmals nennenswerte Aufträge eines asiatischen IDMs (Integrated-Device-Manufacturer) für den Einsatz in die Volumenproduktion verbucht werden. Dieser Kunde weitete mit der Bestellung seine bestehenden Produktionskapazitäten erheblich aus. Das Unternehmen verzeichnet zudem, dass auch andere Halbleiterhersteller zunehmend Interesse an dieser Technologie zeigen.

Das Geschäftsjahr 2017 wurde zudem intensiv genutzt, um mit der Entwicklung einer neuen Generation von UV-Projektions-scannern DSC300 zu beginnen. Die neueste Generation der Geräte wird den Kunden ab dem zweiten Quartal 2018 zur Verfügung stehen. Die DSC300 bedient insbesondere den zukunftssträchtigen Markt für FOWLP-Anwendungen.

GESAMTAUSSAGE ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DES KONZERNS – AUSBLICK 2018

Nach dem sehr guten Auftragseingang im Geschäftsjahr 2017 blicken wir optimistisch in das Geschäftsjahr 2018. Das Marktumfeld in der Halbleiterindustrie sowie die generellen Konjunkturaussichten sind weiterhin positiv, auch wenn einige Marktanalysten bereits vor einer Überhitzung der Märkte und somit einem möglichen Rückgang des Wachstums warnen. SÜSS MicroTec startet mit einem hohen Auftragsbestand von 133,4 Mio. € in das neue Geschäftsjahr. Unter Berücksichtigung der zwar weiterhin positiven Aussichten für das erste Halbjahr 2018 gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2018 etwa den Durchschnitt der vergleichbaren Zeiträume der Vorjahre mit etwa 70 Mio. € bis 80 Mio. € erreichen wird, jedoch nicht den außergewöhnlich hohen Wert des Vorjahres (94,5 Mio. €). Darauf aufbauend erwarten wir für den Umsatz im Jahr 2018 einen Wert in der Bandbreite von 195 Mio. € bis 205 Mio. €. Bei diesem Umsatzniveau wird das EBIT für 2018 voraussichtlich in einer Bandbreite von 8,5 Prozent bis 10,0 Prozent und das EBITDA in einer Bandbreite von 11,0 Prozent bis 12,5 Prozent vom Umsatz liegen. Vergleichbare Lizenzträge wie im Vorjahr erwarten wir für 2018 nicht. Die Gründe für die positive Entwicklung der EBIT-Marge sind neben Volumeneffekten aus dem höheren Umsatz insbesondere Effizienzsteigerungen bei internen Abläufen. Auch wird für das Segment Bonder in 2018 erneut ein deutlich positiver Ergebnisbeitrag erwartet. Für das Geschäftsjahr 2018 streben wir zudem wieder einen positiven Free Cashflow an.

Das Segment Lithografie wird im Geschäftsjahr 2018 erneut den größten Umsatz- und Ergebnisbeitrag für den Konzern liefern. Auf Basis des zum Jahresende 2017 gebuchten Auftragsbestands und der Auftragseingangserwartung für das erste Halbjahr 2018 rechnen wir gegenüber 2017 mit einem leicht steigenden Umsatz und einer erhöhten EBIT-Marge. Das EBIT wird im Bereich von 9 Mio. € bis 12 Mio. € erwartet. Für das Segment Bonder erwarten wir einen deutlichen Umsatzanstieg und ein gegenüber dem Vorjahr weiter verbessertes EBIT im einstelligen Millionenbereich. Auch für das Segment Fotomaschinen-Equipment erwarten wir einen leichten Umsatzanstieg bei einem leicht rückläufigen EBIT. Im Vorjahr waren hier Lizenzträge enthalten, die in diesem Jahr plangemäß nicht erwartet werden. Am Ziel, das organische Wachstum unseres operativen Basisgeschäfts aus eigenen liquiden Mitteln bestreiten zu können, halten wir weiterhin fest.

ZUKUNFTSGERICHTETE ANGABEN

Dieser Bericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf zukünftige Entwicklungen des SÜSS MicroTec-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 9. März 2018



Dr. Franz Richter
Vorstandsvorsitzender



Robert Leurs
Finanzvorstand



Walter Braun
Produktionsvorstand

KONZERNABSCHLUSS NACH IFRS

der SÜSS MicroTec SE für das Geschäftsjahr 2017

Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung (IFRS)	108
Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)	109
Konzernbilanz (IFRS)	110
Konzernkapitalflussrechnung (IFRS)	112
Konzerneigenkapital-Veränderungsrechnung (IFRS)	114
Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2017	116
Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2016	118
Segmentberichterstattung (IFRS)	120
Anhang zum IFRS-Konzernabschluss	122
Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung	131
Erläuterungen zu den Aktiva	135
Erläuterungen zu den Passiva	137
Sonstige Angaben	144
Versicherung der gesetzlichen Vertreter	152
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	153

KONZERN-GEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG (IFRS)

<i>in Tsd. €</i>	Anhang	01.01.2017–31.12.2017	01.01.2016–31.12.2016
Umsatzerlöse	(3)	166.524	177.582
Umsatzkosten	(4)	-107.018	-118.955
Bruttoergebnis vom Umsatz		59.506	58.627
Vertriebskosten		-19.572	-20.521
Forschungs- und Entwicklungskosten		-15.186	-14.137
Verwaltungskosten		-13.402	-13.601
Sonstige betriebliche Erträge	(5)	6.342	4.268
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	-3.785	-3.488
Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT):			
EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization)		17.977	15.298
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen	(10)	-4.074	-4.150
Operatives Ergebnis (EBIT)		13.903	11.148
Finanzerträge		57	91
Finanzaufwendungen		-207	-720
Finanzergebnis	(7)	-150	-629
Gewinn vor Steuern		13.753	10.519
Ertragsteuern	(8)	-7.047	-5.517
Gewinn		6.706	5.002
davon SÜSS MicroTec-Aktionäre		6.706	5.002
davon nicht beherrschende Anteile		0	0
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	(9)		
Ergebnis je Aktie in €		0,35	0,26
Ergebnis je Aktie (verwässert)	(9)		
Ergebnis je Aktie in €		0,35	0,26

KONZERN- GESAMTERGEBNISRECHNUNG (IFRS)

<i>in Tsd. €</i>	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2016 – 31.12.2016
Periodenergebnis	6.706	5.002
Posten, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden		
Neubewertung leistungsorientierter Pensionspläne	-293	-168
Latente Steuern	61	69
Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Bestandteile, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden	-232	-99
Posten, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden		
Fremdwährungsanpassung	-3.840	415
Absicherung künftiger Zahlungsströme	0	410
Latente Steuern	0	-115
Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Posten, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden	-3.840	710
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen	-4.072	611
Summe der in der Periode erfassten Erträge und Aufwendungen	2.634	5.613
davon SÜSS MicroTec-Aktionäre	2.634	5.613
davon nicht beherrschende Anteile	0	0

KONZERNBILANZ (IFRS)

<i>in Tsd. €</i>	Anhang	31.12.2017	31.12.2016
Aktiva			
Langfristige Vermögenswerte		42.701	42.782
Immaterielle Vermögenswerte	(11)	2.609	3.522
Geschäfts- oder Firmenwert	(12)	15.573	15.840
Sachanlagen	(13)	23.302	20.563
Sonstige Vermögenswerte	(14)	503	652
Latente Steueransprüche	(8)	714	2.205
Kurzfristige Vermögenswerte		159.249	136.844
Vorräte	(15)	97.945	73.804
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(16)	19.633	24.111
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(17)	483	159
Steuererstattungsansprüche	(18)	83	375
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(19)	36.464	35.621
Sonstige Vermögenswerte	(20)	4.641	2.774
Bilanzsumme		201.950	179.626

<i>in Tsd. €</i>	Anhang	31.12.2017	31.12.2016
Passiva			
Eigenkapital		126.987	124.353
Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec SE		126.987	124.353
Gezeichnetes Kapital	(21)	19.116	19.116
Rücklagen	(21)	110.286	103.811
Kumuliertes übriges Eigenkapital	(21)	-2.415	1.426
Langfristige Schulden		7.246	8.337
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(22)	4.746	4.837
Finanzschulden	(23)	2.500	3.500
Kurzfristige Schulden		67.717	46.936
Rückstellungen	(24)	2.659	5.161
Steuerschulden	(27)	3.582	3.821
Finanzschulden	(23)	1.005	1.007
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(25)	6.748	5.359
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.289	3.362
Sonstige Verbindlichkeiten	(26)	46.434	28.226
Bilanzsumme		201.950	179.626

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (IFRS)

<i>in Tsd. €</i>	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2016 – 31.12.2016
Gewinn (nach Steuern)	6.706	5.002
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	1.244	1.290
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.830	2.860
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	42	52
Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen	432	1.580
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	487	-75
Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	-203	-46
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	-228	619
Veränderung des Vorratsvermögens	-28.205	-6.071
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.938	-10.673
Veränderung der übrigen Vermögenswerte	-2.041	-481
Veränderung der Pensionsrückstellungen	315	-374
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.843	-5.516
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen	18.089	4.381
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-414	1.184
Veränderung der Steuerforderungen und Steuerverbindlichkeiten	1.544	818
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	9.379	-5.450

<i>in Tsd. €</i>	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2016 – 31.12.2016
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-5.976	-3.149
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-512	-493
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6.488	-3.642
Tilgung von Bankdarlehen	-1.000	-4.600
Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten	-2	1
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.002	-4.599
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-1.046	227
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	843	-13.464
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang	35.621	49.085
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode	36.464	35.621
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit enthält		
Zinszahlungen während der Periode	153	667
Zinseinnahmen während der Periode	52	84
Steuerzahlungen während der Periode	5.283	4.724
Steuererstattungen während der Periode	87	1

KONZERNEIGENKAPITAL- VERÄNDERUNGSRECHNUNG (IFRS)

<i>in Tsd. €</i>	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Gewinnrücklage	Bilanzgewinn/ -verlust
Stand 01.01.2016	19.116	97.614	433	762
Entnahme aus der Kapitalrücklage der SÜSS MicroTec AG		-26.067		26.067
Periodenergebnis				5.002
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen				
Gesamtergebnis				5.002
Stand 31.12.2016	19.116	71.547	433	31.831
Stand 01.01.2017	19.116	71.547	433	31.831
Periodenergebnis				6.706
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen				
Gesamtergebnis				6.706
Umgliederung in die Gewinnrücklage			-231	
Stand 31.12.2017	19.116	71.547	202	38.537

Kumuliertes übriges Eigenkapital					Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec SE	Eigenkapital
Posten, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden		Posten, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden				
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	Latente Steuern	Fremd-währungs-anpassungen	Absicherung künftiger Zahlungsströme	Latente Steuern		
-2.845	697	3.258	-410	115	118.740	118.740
					5.002	5.002
-168	69	415	410	-115	611	611
-168	69	415	410	-115	5.613	5.613
-3.013	766	3.673	0	0	124.353	124.353
-3.013	766	3.673	0	0	124.353	124.353
					6.706	6.706
-293	61	-3.840	0	0	-4.072	-4.072
-293	61	-3.840	0	0	2.634	2.634
322	-91					
-2.984	736	-167	0	0	126.987	126.987

ENTWICKLUNG DES KONZERN-ANLAGEVERMÖGENS

Der Anlagenspiegel ist Teil des Konzernanhangs.

ANLAGESPIEGEL 2017

in Tsd. €	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2017	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang
I. Immaterielle Vermögenswerte					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.672	-233	512		61
2. Entwicklungskosten	29.520	-106			
3. Software	0	0			0
4. Andere immaterielle Vermögenswerte	3.337	-283			0
	51.529	-622	512	0	61
II. Geschäfts- oder Firmenwert	30.253	-267			
III. Sachanlagen					
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	16.834	-21	1.589		0
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.999	-1.000	3.037	0	0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.975	-118	1.287	19	448
4. Fahrzeuge	357	-4			0
5. Anlagen im Bau	22	-3	62	-19	
6. Aktivierte Leasinggegenstände					
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	0				
Technische Anlagen und Maschinen	432	-52			89
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0		0
Fuhrpark	32	-3			
	41.651	-1.201	5.975	0	537
IV. Finanzanlagen					
Sonstige Finanzanlagen	2.120				
	2.120	0	0	0	0

Kumulierte Abschreibungen						Restbuchwerte		
31.12.2017	01.01.2017	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017
18.890	16.294	-192	921		36	16.987	2.378	1.903
29.414	29.342	-106	61			29.297	178	117
0	0	0			0	0	0	0
3.054	2.371	-168	262		0	2.465	966	589
51.358	48.007	-466	1.244	0	36	48.749	3.522	2.609
29.986	14.413					14.413	15.840	15.573
18.402	2.634	-14	535		0	3.155	14.200	15.247
15.036	8.731	-647	1.338		0	9.422	4.268	5.614
11.715	8.911	-92	950		431	9.338	2.064	2.377
353	348	-4	7		0	351	9	2
62	0					0	22	62
0	0					0	0	0
291	432	-52			89	291	0	0
0	0	0	0		0	0	0	0
29	32	-3				29	0	0
45.888	21.088	-812	2.830	0	520	22.586	20.563	23.302
2.120	2.120					2.120	0	0
2.120	2.120	0	0	0	0	2.120	0	0

ENTWICKLUNG DES KONZERN-ANLAGEVERMÖGENS

Der Anlagenspiegel ist Teil des Konzernanhangs.

ANLAGESPIEGEL 2016

in Tsd. €	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2016	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang
I. Immaterielle Vermögenswerte					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.231	62	493		114
2. Entwicklungskosten	29.493	27			
3. Software	183	11			196
4. Andere immaterielle Vermögenswerte	3.334	74			71
	51.241	174	493	0	381
II. Geschäfts- oder Firmenwert	30.185	68			
III. Sachanlagen					
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	16.613	25	538		342
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.350	114	1.286	798	549
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.765	32	945		767
4. Fahrzeuge	374	-2			15
5. Anlagen im Bau	432	14	374	-798	
6. Aktivierte Leasinggegenstände					
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	0	0			
Technische Anlagen und Maschinen	669	29			266
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	2	7		31
Fuhrpark	30	2			
	40.254	216	3.150	0	1.970
IV. Finanzanlagen					
Sonstige Finanzanlagen	2.120				
	2.120	0	0	0	0

Kumulierte Abschreibungen							Restbuchwerte		
31.12.2016	01.01.2016	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	
18.672	15.442	47	919		114	16.294	2.789	2.378	
29.520	29.241	27	74			29.342	252	178	
-2	183	11			196	-2	0	0	
3.337	2.109	36	297		71	2.371	1.225	966	
51.527	46.975	121	1.290	0	381	48.005	4.266	3.522	
30.253	14.413					14.413	15.772	15.840	
16.834	2.440	20	516		342	2.634	14.173	14.200	
12.999	7.784	77	1.410		540	8.731	3.566	4.268	
10.975	8.705	26	915		735	8.911	2.060	2.064	
357	342	-2	12		4	348	32	9	
22	0					0	432	22	
0	0					0	0	0	
432	669	29			266	432	0	0	
-1	21	2	7		31	-1	0	0	
32	30	2				32	0	0	
41.650	19.991	154	2.860	0	1.918	21.087	20.263	20.563	
2.120	2.120					2.120	0	0	
2.120	2.120	0	0	0	0	2.120	0	0	

SEGMENTBERICHTERSTATTUNG (IFRS)

Die Segmentberichterstattung ist Teil des Konzernanhangs.

SEGMENTINFORMATIONEN NACH GESCHÄFTSFELDERN

in Tsd. €	Lithografie		Bonder	
	2017	2016	2017	2016
Außenumsatz	112.803	133.771	22.096	13.983
Innenumsatz	0	0	0	0
Gesamter Umsatz	112.803	133.771	22.096	13.983
Segmentergebnis (EBIT)	6.338	13.170	3.284	-1.697
Ergebnis vor Steuern	6.298	13.144	3.277	-1.701
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen (-)/Erträge	-980	-1.871	625	314
Segmentvermögen	94.694	83.311	24.596	12.364
davon Geschäfts- oder Firmenwert	15.573	15.840	0	0
Nicht zugeordnetes Konzernvermögen				
Konzernaktiva				
Segmentsschulden	-34.002	-23.969	-6.856	-7.301
Nicht zugeordnete Konzernschulden				
Konzernschulden				
Abschreibungen	1.708	1.759	260	260
davon planmäßig	1.708	1.759	260	260
davon außerplanmäßig	0	0	0	0
Investitionen	1.512	1.446	211	159
Mitarbeiter zum 31.12.	486	452	94	86

SEGMENTINFORMATIONEN NACH REGIONEN

in Tsd. €	Umsatzerlöse		Investitionen		Vermögen (ohne Goodwill)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
EMEA	38.802	43.131	6.150	2.914	125.092	90.065
Nordamerika	26.621	25.402	292	594	14.968	27.523
Asien und Pazifik	101.101	109.049	46	134	4.127	6.466
Konsolidierungseffekte	0	0	0	0	-698	-2.054
Gesamt	166.524	177.582	6.488	3.642	143.489	122.000

Fotomasken-Equipment		Sonstige		Konsolidierungseffekte		Summe	
2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
19.702	19.693	11.923	10.135	–	–	166.524	177.582
0	0	6.180	7.025	-6.180	-7.025	0	0
19.702	19.693	18.103	17.160	-6.180	-7.025	166.524	177.582
5.093	1.818	-812	-2.143	–	–	13.903	11.148
5.091	1.814	-913	-2.738	–	–	13.753	10.519
-194	443	-163	-1.089	–	–	-712	-2.203
13.690	19.088	26.082	23.077	–	–	159.062	137.840
0	0	0	0	–	–	15.573	15.840
						43.018	41.786
						202.080	179.626
-11.309	-4.320	-7.820	-2.175	–	–	-59.987	-37.765
						-14.937	-17.508
						-74.924	-55.273
132	136	1.974	1.995	–	–	4.074	4.150
132	136	1.974	1.995	–	–	4.074	4.150
0	0	0	0	–	–	0	0
175	89	4.590	1.948	–	–	6.488	3.642
115	103	84	70	–	–	779	711

ANHANG ZUM IFRS-KONZERNABSCHLUSS

der SÜSS MicroTec SE (vormals: SÜSS MicroTec AG) für das Geschäftsjahr 2017

(1) BESCHREIBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Die SÜSS MicroTec SE (das „Unternehmen“ oder die „Gesellschaft“) mit Sitz in Garching bei München, Schleißheimer Str. 90, und ihre Tochtergesellschaften bilden einen international tätigen Konzern, der Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching und Sternenfels in Deutschland sowie Corona (Kalifornien) in den USA und Hauterive (Kanton Neuchâtel) in der Schweiz. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbstständige Vertriebsgesellschaften in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Japan, Singapur, Taiwan, China und Korea. In Ländern, in denen der Konzern nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

(2) ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

A) GRUNDLAGE DER DARSTELLUNG

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den zugehörigen Interpretationen des IFRS Interpretations Committee (IFRIC) aufgestellt, wie sie in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Der Konzernabschluss wurde grundsätzlich auf Basis historischer Anschaffungs- und Herstellungskosten erstellt. Historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten basieren im Allgemeinen auf dem beizulegenden Zeitwert der im Austausch für den Vermögenswert entrichteten Gegenleistung. Davon ausgenommen sind bestimmte Finanzinstrumente, die zum beizulegenden Zeitwert am Bilanzstichtag angesetzt wurden. Eine entsprechende Erläuterung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Die Anforderungen der IFRS wurden vollständig erfüllt und führen zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns.

Die Gesellschaft ist eine Societas Europaea (SE) und unterliegt deutschem Recht. Die SÜSS MicroTec SE ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SÜSS MicroTec AG; die Umwandlung wurde am 9. August 2017 ins Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts München eingetragen. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des § 315e

HGB aufstellen, da es sich bei der SÜSS MicroTec SE um ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen handelt. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 315 HGB erstellt.

Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2017 werden beim Bundesanzeiger eingereicht und veröffentlicht.

B) ERSTMALIG ANGEWANDTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Im Geschäftsjahr 2017 hat die SÜSS MicroTec SE die nachfolgenden Änderungen zu bestehenden Standards erstmalig angewendet:

- Änderungen zum IAS 7 „Statements of Cash Flows“ (vom IASB am 29. Januar 2016 veröffentlicht)
- Änderungen zum IAS 12 „Income Taxes“ (vom IASB im Januar 2016 veröffentlicht)

Aus der erstmaligen Anwendung der geänderten Standards haben sich keine Auswirkungen auf die Darstellung des Abschlusses der SÜSS MicroTec SE ergeben.

Die SÜSS MicroTec SE hat außerdem die Änderungen von Standards, die sich aus den jährlichen Verbesserungen der IFRS des Zyklus 2014 bis 2016 ergeben haben, im Geschäftsjahr 2017 berücksichtigt. Aus der erstmaligen Anwendung haben sich keine Auswirkungen auf die Darstellung des Abschlusses ergeben.

C) NICHT VORZEITIG ANGEWANDTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Das IASB hat die nachfolgend dargestellten Standards, Interpretationen und Änderungen von Standards bzw. Interpretationen herausgegeben, deren Anwendung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verpflichtend ist:

IFRS 9 „Financial Instruments“

IFRS 9 „Financial Instruments“ wurde vom IASB erstmals in November 2009 bekannt gemacht. Die finale Fassung wurde im Juli 2014 veröffentlicht und im November 2016 in EU-Recht übernommen. IFRS 9 enthält Vorschriften für den Ansatz, die Bewertung und Ausbuchung von Finanzinstrumenten sowie für die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen. Die bisher unter IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“ vorgenommene Bilanzierung von Finanzinstrumenten kann nun vollständig durch die Bilanzierung unter IFRS 9 ersetzt werden. Die letzten Änderungen an IFRS 9 erfolgten am 12. Oktober 2017.

Die zentralen Anforderungen des finalen IFRS 9 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Regelungen von IFRS 9 sehen im Vergleich zu IAS 39 ein neues Klassifizierungsmodell für finanzielle Vermögenswerte vor. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte richtet sich künftig nach drei Kategorien mit unterschiedlichen Wertmaßstäben und einer unterschiedlichen Erfassung von Wertänderungen.
- Für finanzielle Schulden wurden die bestehenden Vorschriften des IAS 39 weitgehend unverändert in IFRS 9 übernommen. Die einzig wesentliche Neuerung betrifft finanzielle Verbindlichkeiten in der Fair-Value-Option.
- IFRS 9 sieht drei Stufen vor, welche die Höhe der zu erfassenden Verluste und die Zinsvereinnahmung künftig bestimmen.
- Neben umfangreichen Übergangsvorschriften ist IFRS 9 auch mit umfangreichen Offenlegungsvorschriften sowohl beim Übergang als auch in der laufenden Anwendung verbunden.

IFRS 9 ist für alle Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen. Die Erstanwendung hat grundsätzlich retrospektiv zu erfolgen, jedoch werden diverse Vereinfachungsoptionen gewährt. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

SÜSS MicroTec wird IFRS 9 erstmalig zum 1. Januar 2018 anwenden. Die tatsächlichen Auswirkungen der Anwendung des IFRS 9 auf den Konzernabschluss im Jahr 2018 können nicht verlässlich geschätzt werden, da sie von den Finanzinstrumenten, die der Konzern hält, und den wirtschaftlichen Bedingungen zu diesem Zeitpunkt abhängen sowie von Ermessensentscheidungen, die künftig vom Konzern getroffen werden. Auf Basis der derzeit ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Schulden geht SÜSS MicroTec jedoch davon aus, dass das neue Klassifizierungsmodell und die neuen Bewertungsmethoden des IFRS 9 keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns bei Erstanwendung des neuen Standards haben werden.

IFRS 15: „Revenue from Contracts with Customers“

Der neue IFRS 15 „Revenue from Contracts with Customers“ wurde vom IASB im Mai 2014 veröffentlicht und schreibt vor, wann und in welcher Höhe Erlöse zu erfassen sind. Zielsetzung des neuen Standards zur Umsatzrealisierung ist es, die Vielzahl der bisher in diversen Standards und Interpretationen enthaltenen Regelungen zusammenzuführen. Gleichzeitig werden einheitliche Grundprinzipien festgelegt, die für alle Branchen und für alle Arten von Umsatztransaktionen anwendbar sind. Die Fragen, in welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt bzw. über welchen Zeitraum Umsatz zu realisieren ist, sind mit Hilfe eines prinzipienbasierten fünfstufigen Modells zu beantworten. Daneben enthält IFRS 15 eine Reihe von weiteren Regelungen zu Detailfragestellungen sowie eine Ausweitung der erforderlichen Anhangsangaben.

Am 11. September 2015 veröffentlichte das IASB eine Änderung des IFRS 15, mit der sich der Erstanwendungszeitpunkt um ein Jahr auf den 1. Januar 2018 verschiebt. Damit sind die neuen Regelungen zur Umsatzlegung nun für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen. Der neue Standard wurde im Oktober 2016 in europäisches Recht übernommen.

SÜSS MicroTec hat in 2016 ein Projekt zur konzernweiten Einführung von IFRS 15 gestartet. Das Projekt umfasste eine detaillierte Analyse, inwieweit die einzelnen Vertragskonstellationen, die SÜSS MicroTec mit Kunden üblicherweise abschließt, von den Neuregelungen des IFRS 15 betroffen sind. Im Rahmen eines zentralen Workshops mit Teilnehmern aus allen relevanten Unternehmensbereichen wurden im Herbst 2016 alle potenziellen Auswirkungen des IFRS 15 diskutiert und die entsprechenden Einschätzungen dokumentiert. Für SÜSS MicroTec relevante Themen mit möglichem Anpassungsbedarf wurden identifiziert und zu einer Shortlist konsolidiert. Das Projekt wurde im Herbst 2017 zu Ende gebracht. SÜSS MicroTec wird in 2018 noch ergänzende Analysen in Bezug auf zukünftige Anhangangaben durchführen und – bei Bedarf – das Konzernreporting entsprechend anpassen.

Auf Grundlage der durchgeführten Detailanalyse wurden – verglichen mit der bisherigen Umsatzerfassung – folgende Erkenntnisse gewonnen:

- Basierend auf der durchgeführten Analyse geht SÜSS MicroTec davon aus, dass im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Maschine die Kombination aus Produktion, Lieferung und Installation der Maschine sowie die Initialschulung des Kunden und die gesetzliche Gewährleistung insgesamt eine unterscheidbare Leistungsverpflichtung im Sinne des IFRS 15 darstellt.
- Es ist zu erwarten, dass Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen, die derzeit mit Endabnahme durch den Kunden realisiert werden, auch weiterhin zeitpunktbezogen zu realisieren sind. Der Zeitpunkt der Endabnahme durch den Kunden stellt den Zeitpunkt des Kontrollübergangs auf den Kunden dar. Bei der ganz überwiegenden Anzahl der produzierten Maschinen geht SÜSS MicroTec von einem alternativen Nutzen aus.
- Bei Kundenverträgen, die mehrere separierbare Leistungsverpflichtungen umfassen, ist gemäß IFRS 15 der gesamte Transaktionspreis anhand der Relation der Einzelveräußerungspreise auf die einzelnen Leistungsverpflichtungen zu allokieren. Dadurch wird die zeitliche Verteilung der Umsatzerfassung beeinflusst. Kundenverträge können mehrere Leistungsverpflichtungen enthalten, die jeweils unterschiedlich rabattiert sein können. SÜSS MicroTec wird bei jedem Einzelfall prüfen, ob der mit dem Kunden vereinbarte Verkaufspreis pro Leistungsverpflichtung vom Einzelveräußerungspreis abweicht und damit eine Reallokation des Transaktionspreises auf einzelne Leistungsverpflichtungen erfolgen muss.
- Sollten Vertragskombinationen vorliegen, muss gemäß IFRS 15 eine Reallokation der Transaktionspreise zwischen einzelnen Verträgen vorgenommen werden. Dadurch wird die zeitliche Verteilung der Umsatzerfassung beeinflusst. SÜSS MicroTec geht jedoch davon aus, dass Vertragskombinationen nur sehr vereinzelt auftreten werden.
- Daneben geht SÜSS MicroTec von unwesentlichen Anpassungen in der Bilanz (zum Beispiel durch separate Posten für Contract-Assets und Contract-Liabilities) und zusätzlichen quantitativen und qualitativen Anhangsangaben aus.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die Umstellung auf IFRS 15 bei SÜSS MicroTec keine gravierenden Änderungen in Art und Zeitpunkt der Umsatzrealisierung zu

erwarten sind. Aus der Reallokation von Transaktionspreisen auf mehrere Leistungsverpflichtungen bzw. mehrere Kundenverträge können sich jedoch zeitliche Unterschiede in der Realisation von Teilen der Umsatzerlöse ergeben. Insgesamt geht die SÜSS MicroTec SE auf Basis der durchgeführten Analyse davon aus, dass sich aus der Umstellung auf IFRS 15 keine wesentlichen Auswirkungen ergeben werden.

IFRIC 22 „Foreign Currency Transactions and Advance Consideration“

Am 8. Dezember 2016 hat das IASB IFRIC 22 veröffentlicht. Damit wird klargestellt, auf welchen Zeitpunkt der Wechselkurs für die Umrechnung von Transaktionen in Fremdwährung zu ermitteln ist, die erhaltene oder geleistete Anzahlungen beinhalten. IFRIC 22 ist ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden; eine frühere Anwendung ist zulässig. SÜSS MicroTec erwartet aus der erstmaligen Anwendung von IFRIC 22 keine Auswirkungen.

IFRS 16 „Leases“

Am 13. Januar 2016 hat das IASB IFRS 16 „Leases“ veröffentlicht. Kerngedanke des neuen Standards ist es, beim Leasingnehmer generell alle Leasingverhältnisse und die damit verbundenen vertraglichen Rechte und Verpflichtungen in der Bilanz zu erfassen. Die bisher unter IAS 17 erforderliche Unterscheidung zwischen Finanzierungs- und Operating-Leasingverträgen entfällt damit künftig für den Leasingnehmer. Die neuen Regelungen sind verpflichtend anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen. Der Standard wurde noch nicht in EU-Recht übernommen.

SÜSS MicroTec hat mit einer ersten Beurteilung der möglichen Auswirkungen auf seinen Konzernabschluss begonnen. Bislang wurde als wesentlichste Auswirkung identifiziert, dass der Konzern neue Vermögenswerte und Schulden für sämtliche gemieteten Räume und Flächen erfassen wird. Auch für die geleasteten Firmfahrzeuge werden neue Vermögenswerte und Schulden in der Bilanz zu erfassen sein. Die Gebäude in Garching und Sternenfels, an denen die SÜSS MicroTec SE, die SÜSS MicroTec Lithography GmbH und die SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG ihren Sitz haben, stehen im Eigentum der SÜSS MicroTec SE und sind somit von den Neuregelungen des IFRS 16 nicht betroffen. Die Art der Aufwendungen, die mit den Miet- und Leasingverhältnissen verbunden sind, wird sich insofern ändern, als die linearen Aufwendungen für die Operating-Leasingverhältnisse durch einen Abschreibungsaufwand für Nutzungsrechte (Right-of-Use-assets) und Zinsaufwendungen für Schulden aus dem Leasingverhältnis ersetzt werden.

IFRS 17 „Insurance Contracts“

Am 18. Mai 2017 hat das IASB IFRS 17 veröffentlicht. IFRS 17 ersetzt IFRS 4 und regelt die Bilanzierung von Versicherungsverträgen. IFRS 17 ist ab dem 1. Januar 2021 anzuwenden. SÜSS MicroTec sieht für die Regelungen des IFRS 17 keinen Anwendungsbereich.

IFRIC 23 „Uncertainty over Income Tax Treatments“

Am 7. Juni 2017 hat das IASB IFRIC 23 veröffentlicht. IFRIC 23 hat die Bilanzierung von Unsicherheit in Bezug auf Ertragsteuern zum Inhalt. IFRIC 23 ist ab dem 1. Januar 2019 anzuwenden; eine frühere Anwendung ist zulässig. SÜSS MicroTec erwartet aus der erstmaligen Anwendung von IFRIC 23 keine Auswirkungen.

IAS 28 „Investments in Associates and Joint Ventures“

Am 12. Oktober 2017 hat das IASB Änderungen an IAS 28 veröffentlicht. Damit wird die Anwendbarkeit von IFRS 9 „Financial Instruments“ auf langfristige Beteiligungen an einem assoziierten Unternehmen klargestellt. IAS 28 in der neuen Fassung ist ab dem 1. Januar 2019 anzuwenden. SÜSS MicroTec erwartet aus der erstmaligen Anwendung von IAS 28 keine Auswirkungen.

Jährliche Verbesserungen an den IFRS – Zyklus 2015 – 2017

Am 12. Dezember 2017 hat das IASB jährliche Verbesserungen an den IFRS – Zyklus 2015 – 2017 veröffentlicht. Das Projekt hatte Änderungen an IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 und IAS 23 zum Inhalt. Die Änderungen sind ab dem 1. Januar 2019 anzuwenden. SÜSS MicroTec erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

D) WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Konzernabschluss erfüllt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS den Grundsatz des True and Fair View sowie der Fair Presentation. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert gegenüber Vorjahr angewendet.

Geschäfts- oder Firmenwert

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschäfts- oder Firmenwert nicht planmäßig abgeschrieben, sondern einmal jährlich auf Wertminderung überprüft. Eine Überprüfung erfolgt auch, wenn Ereignisse oder Umstände (Triggering Events) eintreten, die auf eine mögliche Wertminderung hindeuten.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit des Goodwills erfolgt auf der Ebene zahlungsmittelgenerierender Einheiten (Cash Generating Units), die im SÜSS MicroTec-Konzern den operativen Segmenten entsprechen.

Eine Wertminderung wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch den erzielbaren Betrag der jeweiligen Cash Generating Unit gedeckt sind. Der erzielbare Betrag ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Verkaufskosten und Nutzungswert. Die SÜSS MicroTec SE hat im Berichtsjahr den erzielbaren Betrag der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten auf der Basis des Nutzungswerts errechnet. Dieser Wert beruht grundsätzlich auf Bewertungen mittels diskontierter Mittelzuflüsse.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden gemäß IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass mit der Nutzung des Vermögenswerts ein zukünftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermögenswerts zuverlässig bestimmt werden können. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal zehn Jahre beträgt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Aufwandszuordnung möglich ist und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt sind. Die Entwicklungstätigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschließlich entwicklungsbezogener Gemeinkosten. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab Produktionsstart planmäßig linear über den erwarteten Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis fünf Jahren abgeschrieben.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SÜSS MicroTec-Gruppe nicht vor.

Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauern für die wesentlichen Anlagekategorien sind nachstehend wiedergegeben:

Gebäude, Einbauten	10–40 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	4–5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3–5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre

Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird gemäß IAS 17 zwischen „Finance Lease“ und „Operating Lease“ unterschieden. Gegenstände des „Finance Lease“ werden unter Ansatz des Barwerts aller künftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingschuld wird gemäß den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrags getilgt und verzinst. Beim „Operating Lease“ erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der periodisierten Leasingzahlungen im Aufwand.

Eine Neubewertung der Sachanlagen gemäß den Regelungen des IAS 16 erfolgt nicht.

Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

Eine Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts sowie auf Sachanlagen wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch die zu erwartenden Veräußerungserlöse bzw. die diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt sind. Ist die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Die Zuordnung des Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt auf der Grundlage der Berichtseinheiten (Segmente).

Sofern in den Folgeperioden die Gründe für die Wertminderungen entfallen sind, werden Zuschreibungen vorgenommen. Die Zuschreibung erfolgt dabei höchstens auf den Betrag, der sich ohne die Vornahme der Wertminderung ergeben hätte. Eine Zuschreibung auf abgewertete Geschäfts- oder Firmenwerte erfolgt nicht.

Vorräte

Die Vorräte werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert bewertet. Der Nettoveräußerungswert stellt dabei den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der bis zum Verkauf noch anfallenden Kosten dar. Zudem werden Bestandsrisiken des Vorratsvermögens, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und technischen Risiken ergeben, durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Herstellungskosten der unfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt die Ermittlung der Anschaffungskosten auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnittswerts.

Bei Wegfall der Gründe, die zu einer Wertberichtigung der Vorräte geführt haben, wird eine entsprechende Wertaufholung vorgenommen.

Finanzinstrumente

Finanzinstrumente sind Vertragsverhältnisse, die bei der einen Partei zu einem finanziellen Vermögenswert und bei der anderen Partei zu einer finanziellen Schuld oder zu einem Eigenkapitalinstrument führen. Diese werden in die Klassen „bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten“, „bewertet zu Marktwerten“ und in „Leasingverbindlichkeiten“ eingeteilt.

Das Unternehmen erfasst Finanzinstrumente in der Bilanz, sobald die SÜSS MicroTec-Gruppe Vertragspartner eines Finanzinstruments wird. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Marktwert. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt entsprechend der Kategorie, der sie zugeordnet sind – den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögens-

werten, den Krediten und Forderungen, den finanziellen Verbindlichkeiten oder den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Die Kategorien „Held to Maturity“ sowie die „Fair Value Option“ werden nicht genutzt.

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie „Kredite und Forderungen“ zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen. Darüber hinaus werden Wertberichtigungen in Abhängigkeit von der Altersstruktur überfälliger Forderungen gebildet. Diese Wertminderungen werden auf separaten Wertberichtigungskonten erfasst.

Wertpapiere

Wertpapiere werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert, da sie nicht zu Spekulationszwecken gehalten werden. Sie werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert, sofern dieser verlässlich ermittelbar ist. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden unter Berücksichtigung latenter Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Zahlungsmitteläquivalente umfassen alle liquiditätsnahen Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. der Anlage eine Restlaufzeit von weniger als drei Monaten haben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden gemäß IAS 19 („Employee Benefits“) bilanziert.

Beitragsorientierte Pläne („Defined Contribution Plans“) führen in der Regel nicht zu einer Rückstellungsbildung, da sich die Verpflichtung des Unternehmens auf die Zahlung von Beiträgen an den Versorgungsträger/Fonds beschränkt. Die Prämienzahlungen an die Versorgungsträger/Fonds werden in der Periode ihres Anfalls als Aufwand erfasst.

Bei leistungsorientierten Plänen („Defined Benefit Plans“) besteht die Verpflichtung des Unternehmens in der Gewährung der zugesagten Leistungen an aktive und frühere Arbeitnehmer. Leistungsorientierte Pläne führen in der Regel zur Bildung von Pensionsrückstellungen.

Die Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen (Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung abzüglich bewerteten Planvermögens) wird mittels des Anwartschaftsbarwertverfahrens („Projected Unit Credit Method“) berechnet. Zukünftige

Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermögenswerte (zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Planvermögen). Die Effekte aus der Neubewertung der Nettoschuld (versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, Erträge aus dem Planvermögen sowie die Veränderungen in der Auswirkung der Vermögensobergrenze) werden in voller Höhe im kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Im Fall künftiger Planänderungen wird der nachzuverrechnende Dienstzeitaufwand sofort ergebniswirksam erfasst.

Rückstellungen

Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, deren Inanspruchnahme wahrscheinlich und die voraussichtliche Höhe des notwendigen Rückstellungsbetrags zuverlässig schätzbar ist. Die Bewertung erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Rückstellungen werden auf Grundlage angemessener Zinssätze mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt.

Finanzschulden

Die Finanzschulden umfassen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden der Kategorie „finanzielle Verbindlichkeiten“ zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing, die der Klasse „Leasingverbindlichkeiten“ zugeordnet sind, werden gemäß IAS 17 bewertet.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie „finanzielle Verbindlichkeiten“ zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden der Kategorie „finanzielle Verbindlichkeiten“ zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Leasing

Die Feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält, wird auf Basis des wirtschaftlichen Gehalts der Vereinbarung zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung getroffen und erfordert eine Einschätzung, ob die Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung von der Nutzung eines bestimmten Vermögenswerts oder bestimmter Vermögenswerte abhängig ist und ob die Vereinbarung ein Recht auf die Nutzung des Vermögenswerts einräumt, selbst wenn dieses Recht in einer Vereinbarung nicht ausdrücklich festgelegt ist.

Bei Leasingvereinbarungen, die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurden, gilt in Übereinstimmung mit den Übergangsvorschriften von IFRIC 4 der 1. Januar 2005 als Zeitpunkt des Abschlusses der Leasingvereinbarung.

Finanzierungs-Leasingverhältnisse, bei denen im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Chancen und Risiken am Leasinggegenstand auf den Konzern übertragen werden, führen zur Aktivierung des Leasinggegenstands zu Beginn der Laufzeit des Leasingverhältnisses. Der Leasinggegenstand wird mit seinem beizulegenden Zeitwert angesetzt oder mit dem Barwert der Mindestleasingzahlungen, sofern dieser Wert niedriger ist. Leasingzahlungen werden derart in Finanzierungsaufwendungen und den Tilgungsanteil der Restschuld aufgeteilt, dass sich über die Laufzeit des Leasingverhältnisses ein konstanter Zinssatz auf die verbliebene Leasingverbindlichkeit ergibt. Finanzierungsaufwendungen werden erfolgswirksam erfasst.

Leasinggegenstände werden über die Nutzungsdauer des Gegenstands abgeschrieben. Ist der Eigentumsübergang auf den Konzern am Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses jedoch nicht hinreichend sicher, wird der Leasinggegenstand über den kürzeren der beiden Zeiträume aus erwarteter Nutzungsdauer und Laufzeit des Leasingverhältnisses vollständig abgeschrieben. Leasingzahlungen für Operating-Leasingverhältnisse werden linear über die Laufzeit des Leasingverhältnisses als Aufwand für Operating-Leasingverhältnisse in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Nicht fortgeführte Aktivitäten

Nicht fortgeführte Aktivitäten werden ausgewiesen, sobald ein Unternehmensbestandteil mit Geschäftsaktivitäten und Cashflows, die operativ und für Zwecke der Rechnungslegung vom restlichen Unternehmen klar abgegrenzt werden können, als zur Veräußerung klassifiziert wird oder bereits abgegangen ist und der Geschäftsbereich einen gesonderten wesentlichen Geschäftszweig darstellt.

Umsatzrealisierung

Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen werden gemäß IAS 18 erfasst, wenn die Voraussetzungen zur Umsatzrealisierung erfüllt sind. Umsatzerlöse werden zum Zeitpunkt der Übertragung der maßgeblich mit dem Eigentum der verkauften Ware verbundenen Risiken und Chancen auf den Käufer realisiert, wenn es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Gesellschaft der wirtschaftliche Nutzen aus dem Verkauf zufließen wird. Die Höhe der erfassten Umsatzerlöse basiert auf den beizulegenden Zeitwerten der zu erhaltenen oder zu beanspruchenden Gegenleistung.

Kundenaufträge der Gesellschaft beinhalten in der Regel Installationsleistungen, die notwendig sind, um die verkaufte Maschine in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Aufgrund der grundsätzlich vorliegenden Komplexität der Installationsvorgänge geht die Gesellschaft davon aus, dass regelmäßig signifikante Eigentumsrisiken bis zum Abschluss der Installation beim Unternehmen verbleiben. Daher wird bei Verträgen, bei denen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und die

Endabnahme mit dem Kunden vereinbart sind, der Umsatz grundsätzlich erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind und die Endabnahme durch den Kunden erfolgt ist.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung, oder bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert. Im Fall von Ersatzteilverkäufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.

Umsatzkosten

Die Umsatzkosten umfassen die den Umsatzerlösen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften Erzeugnisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinkosten einschließlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermögenswerte sowie die Abwertungen auf die Vorräte.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Aufwendungen für Forschung und nicht aktivierungsfähige Entwicklungen werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfasst. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind auch Lizenzerträge erfasst, die – entsprechend IAS 18.IE20 – eine zeitlich unbefristete Nutzung des übertragenen Prozess-Know-Hows beinhalten.

Latente Steuern

Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 („Income Taxes“) für alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermögenswerte und Schulden und deren Wertansätzen in der IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueransprüche auf temporäre Differenzen bzw. Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, wenn ihre Realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint.

Auf temporäre Unterschiede beim Geschäfts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschäfts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden können.

Ergebnis pro Aktie (EPS – Earnings per Share)

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 („Earnings per Share“).

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wird.

Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken werden in der SÜSS MicroTec-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß IAS 39. Derivative Finanzinstrumente werden den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zugeordnet, zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertänderungen werden entweder in der Gewinn- und Verlustrechnung oder, sofern es sich um einen Cashflow-Hedge handelt, nach der Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

Cashflow-Hedges

Der effektive Teil der Marktwertänderungen derivativer Instrumente, die als Cashflow-Hedges bestimmt sind, wird nach Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Der ineffektive Teil wird sofort erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Bilanzierung von Zuschüssen

Zuwendungen aus der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 („Accounting for Government Grants“) nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsätzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die durch die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschüsse, die sich auf aktivierungsfähige Entwicklungskosten beziehen, werden von diesen abgesetzt.

Transaktionen in Fremdwährung

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet. Vermögenswerte und Schulden in Fremdwährung werden mit dem geltenden Währungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale Währung umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam erfasst.

E) VERWENDUNG VON SCHÄTZUNGEN

Die Aufstellung des Konzernabschlusses nach den IFRS verlangt Einschätzungen und Annahmen, die Einfluss auf den Ausweis von Vermögenswerten und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen haben. Die tatsächlichen Werte können in Einzelfällen von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst in erheblichem Maß Einschätzungen und Beurteilungen einzelner Forderungen, die auf der Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen Konjunkturlageentwicklungen und der Analyse historischer Forderungsausfälle auf Portfoliobasis beruhen. Soweit das Unternehmen die Wertberichtigung aus historischen Ausfallraten auf Portfoliobasis ableitet, vermindert ein Rückgang des Forderungsvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt. Zum 31. Dezember 2017 betrug die gesamte Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 884 Tsd. € (Vorjahr: 396 Tsd. €).

Wertminderungen

Die SÜSS MicroTec SE überprüft den Geschäfts- oder Firmenwert mindestens einmal jährlich auf mögliche Wertminderung. Die Bestimmung des erzielbaren Betrags einer Cash Generating Unit, der der Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet wurde, ist mit Schätzungen des Managements verbunden. Der erzielbare Betrag ist der höhere Wert aus dem beizulegenden Zeitwert, abzüglich der Verkaufskosten, und dem Nutzungswert. Die Gesellschaft bestimmt diese Werte grundsätzlich mit Bewertungsmethoden, die auf diskontierten Cashflows basieren. Diese diskontierten Cashflows werden für einen Fünf-Jahres-Zeitraum ermittelt. Dabei werden für die unmittelbare Zukunft die aus der Konzernplanung abgeleiteten Cashflows zugrunde gelegt. Für die über die Detailplanungsperiode hinausgehenden Cashflow-Prognosen werden geeignete Forecasts aus der Halbleiterzulieferindustrie herangezogen. Auf Basis dieser Forecasts wird für jedes Jahr des Betrachtungszeitraums eine Wachstumsrate ermittelt. Für den Fünf-Jahres-Zeitraum errechnet sich für die Cash Generating Unit Lithografie, der der bilanzierte Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist, ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 8,3 % (Vorjahr: 1,5 %). Nach dem Ende des fünfjährigen Planungshorizonts wird für die folgenden Jahre eine Umsatzsteigerungsrate von 1,0 % p. a. angenommen. Die Diskontierung der prognostizierten Netto-Cashflows wird unter Nutzung eines risikoadjustierten Zinssatzes in Höhe von 8,53 % (Vorjahr: 8,80 %) durchgeführt. Diese Prämissen sowie die zugrunde liegende Methodik können einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts haben.

Ist im Rahmen von Wertminderungstests bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögens-

werten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Auch bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten ist die Bestimmung des erzielbaren Betrags der Vermögenswerte gleichermaßen mit Schätzungen des Managements verbunden, was einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung haben kann.

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Verpflichtungen für Pensionen und damit zusammenhängende Aufwendungen und Erträge werden in Übereinstimmung mit versicherungsmathematischen Bewertungen ermittelt. Diese Bewertungen beruhen auf Schlüsselprämissen, darunter Abzinsungsfaktoren, die erwartete Rendite des Fondsvermögens, Gehaltstrends sowie Lebenserwartungen. Die angesetzten Abzinsungsfaktoren spiegeln die Zinssätze wider, die am Bilanzstichtag für hochwertige festverzinsliche Anlagen mit entsprechender Laufzeit erzielt werden.

Aufgrund schwankender Markt- und Wirtschaftslage können die zugrunde gelegten Prämissen von der tatsächlichen Entwicklung abweichen, was wesentliche Auswirkungen auf die Verpflichtungen für Pensionen haben kann.

Rückstellungen

Die Bestimmung von Rückstellungen für vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche ist in erheblichem Maß mit Einschätzungen verbunden. Soweit das Unternehmen diese Rückstellungen aus historischen Garantie- und Gewährleistungsfällen ableitet, vermindert ein Rückgang des Umsatzvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert. Sie werden ausgebucht, wenn die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen sind. Abhängig vom Inhalt der vertraglichen Vereinbarungen sind Schätzungen notwendig, um den wahrscheinlichen Erfüllungsbetrag zu bestimmen.

Purchase-Price-Allocation

Bei Unternehmenserwerben nach IAS 27 (rev. 2008) und IFRS 3 (rev. 2008) ist der Kaufpreis für den Unternehmenserwerb auf die beim Kauf erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden vorzunehmen. Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden sind mit einzelnen Ausnahmen (z. B. Steuerschulden, Pensionsverpflichtungen, anteilsbasierte Vergütungen) zum beizulegenden Zeitwert anzusetzen. Hierbei sind nicht nur bilanzierte Vermögenswerte zu berücksichtigen, sondern auch bislang nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte.

F) KONSOLIDIERUNG

Konsolidierungsgrundsätze

In den Konzernabschluss werden die SÜSS MicroTec SE sowie alle aktiven Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Beherrschung liegt vor, wenn die SÜSS MicroTec SE die Verfügungsgewalt hat, an positiven und negativen variablen Rückflüssen einer Gesellschaft zu partizipieren, und diese Rückflüsse durch ihre Verfügungsgewalt beeinflussen kann. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

Umrechnung von Jahresabschlüssen in fremder Währung

Die Darstellungswährung des Konzerns ist der Euro, die der funktionalen Währung der Muttergesellschaft entspricht. Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

	2017		2016	
	Bilanz	G&V	Bilanz	G&V
1 EUR vs. 1 USD	1,199	1,131	1,056	1,103
1 EUR vs. 1 JPY	134,889	127,024	123,494	121,096
1 EUR vs. 1 GBP	0,887	0,875	0,858	0,816
1 EUR vs. 1 CHF	1,169	1,113	1,075	1,090
1 EUR vs. 1 TWD	35,566	34,414	33,947	35,548
1 EUR vs. 1 SGD	1,602	1,559	1,526	1,526
1 EUR vs. 1 CNY	7,813	7,627	7,361	7,326
1 EUR vs. 1 KRW	1.278,302	1.275,674	1.267,230	1.285,520

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (kumuliertes übriges Eigenkapital) ausgewiesen.

Angaben zum Konsolidierungskreis

Im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 ergaben sich keine Veränderungen im Konsolidierungskreis.

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017 werden demzufolge folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec SE (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Währung).

Gesellschaft / Sitz	Währung	Gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Eigenkapital	Jahresergebnis	Konsolidierung
SÜSS MicroTec SE, Garching ¹	EUR	19.115.538,00	Holding	68.459.564,41	-9.688.806,80	voll
SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching ²	EUR	2.000.100,00	100 %	49.874.921,56	9.148.445,31	voll
SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG, Sternenfels	EUR	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	2.510.578,13	voll
SUSS MicroTec Photomask Equipment Beteiligungs-GmbH, Sternenfels	EUR	25.000,00	100 %	13.063,62	-391,19	voll
SUSS MicroTec Ltd., Market Rasen, Vereinigtes Königreich	GBP	10.000,00	100 %	274.916,21	43.158,20	voll
SUSS MicroTec KK, Yokohama, Japan	JPY	30.000.000,00	100 %	-757.390.710,00	-64.992.470,00	voll
SUSS MicroTec SARL, Pierre Bénite, Frankreich	EUR	114.750,00	100 %	2.270.500,37	557.601,87	voll
SUSS MicroOptics S.A., Hauterive, Schweiz	CHF	500.000,00	100 %	13.156.445,35	2.738.777,27	voll
SUSS MicroTec, Inc., Corona, USA	USD	4.197.000,00	100 %	30.772.223,33	-207.899,26	voll
SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu, Taiwan	TWD	5.000.000,00	100 %	204.776.820,00	36.380.714,00	voll
SUSS MicroTec Company Ltd., Shanghai, China	CNY	1.655.320,00	100 %	55.135.924,70	5.353.614,98	voll
HUGLE Lithography Inc., San Jose, USA ³	USD	1.190.442,00	53,1%	-41.379,00	-1.860,00	–
SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim ²	EUR	25.564,59	100 %	947.988,30	742.116,24	voll
SUSS MicroTec (Singapore) Pte. Ltd., Singapur	SGD	25.000,00	100 %	6.785.847,76	1.167.599,13	voll
SUSS MicroTec Korea Co. Ltd., Hwaseong City, Korea	KRW	50.000.000,00	100 %	2.399.602.897,00	-120.099.786,00	voll
SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA	USD	10.400,00	100 %	-15.465.203,97	4.138.665,83	voll

¹ Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Ergebnisabführungsverträge mit der SÜSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec REMAN GmbH und vor Berücksichtigung der Ergebniszurechnung von der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG.

² Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrags mit der SÜSS MicroTec SE.

³ Wegen Unwesentlichkeit keine Konsolidierung.

Für alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlüsse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.

Von den inländischen Tochtergesellschaften in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft haben die SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching, und die SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, die gemäß § 264 Abs. 3 HGB erforderlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfüllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

Die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG (in der Rechtsform der Personengesellschaft) hat die gemäß § 264 b HGB erforderlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfüllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

ERLÄUTERUNGEN ZUR IFRS-KONZERN-GEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG

Die folgenden Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung beinhalten ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Alle Angaben erfolgen – soweit nichts anderes angegeben ist – in Tsd. €.

(3) UMSATZERLÖSE

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2017	2016
Maschinen	126.008	136.583
Ersatzteile und Upgrades	18.731	19.866
Serviceleistungen	10.158	11.276
Mikrooptik	11.627	9.857
Sonstige	0	0
Umsatzerlöse	166.524	177.582

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlöse auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung.

(4) UMSATZKOSTEN

In den Umsatzkosten sind insgesamt planmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von 61 Tsd. € (Vorjahr: 74 Tsd. €) enthalten, die komplett auf das Segment Lithografie entfallen. Der zum 31. Dezember 2017 verbleibende Restbuchwert der aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von 117 Tsd. € betrifft ebenfalls – wie auch im Vorjahr – ausschließlich das Segment Lithografie.

In den Umsatzkosten des aktuellen Geschäftsjahres sind darüber hinaus planmäßige Abschreibungen auf die erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photonic Systems in Höhe von 262 Tsd. € (Vorjahr: 297 Tsd. €) enthalten. Diese Technologie weist zum 31. Dezember 2017 einen Restbuchwert von 589 Tsd. € auf.

Des Weiteren sind in die Umsatzkosten Wertminderungen auf Lagerbestände (Demogeräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fertige und unfertige Erzeugnisse) von 5.207 Tsd. € (Vorjahr: 5.500 Tsd. €) eingeflossen. Dabei entfallen 4.367 Tsd. € (Vorjahr: 4.658 Tsd. €) auf Bestände des Segments Lithografie und 512 Tsd. € (Vorjahr: 765 Tsd. €) auf Bestände des Segments Bonder. Die Bestände des Segments Fotomaschinen-Equipment wurden um 328 Tsd. € (Vorjahr: 77 Tsd. €) abgewertet.

(5) SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2017	2016
Fremdwährungsgewinne	3.261	2.617
Lizenzträge aus der Übertragung von Prozess-Know-How	1.950	0
Provisionen	423	935
KFZ-Sachbezüge	239	240
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	203	0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28	94
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	6	49
Sonstige Zuschüsse	0	42
Mieterträge	47	49
Sonstiges	185	242
Sonstige betriebliche Erträge	6.342	4.268

Die Fremdwährungsgewinne entstanden im Wesentlichen aus verschiedenen Geschäftsvorfällen im operativen Bereich, die in Fremdwährung abgewickelt wurden (vorwiegend in US-Dollar und japanischen Yen) und durch die unterjährige Veränderung der Wechselkurse beeinflusst waren. Zudem sind hier Erträge aus der Stichtagsbewertung von konzerninternen Verrechnungskonten erfasst, die aus Sicht der bilanzierenden Gesellschaft in Fremdwährung bestehen.

Die Lizenzträge aus der Übertragung von Prozess-Know-How betreffen Erlöse aus einem Lizenzabkommen zur Vermarktung einer von SÜSS MicroTec entwickelten Technologie zum Reinigen von Fotomaschinen. Diese Technologie wurde von der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG entwickelt. Lizenznehmer ist ein führender japanischer Equipment-Hersteller, der bereits Maschinen für die Front-End-Fertigung in seinem Programm hat und nun die von SÜSS MicroTec entwickelte Technologie als ein Modul in seinen Maschinen zum Reinigen von Wafern einsetzen wird.

Die Provisionen wurden im Wesentlichen von unserer Tochtergesellschaft in China erzielt.

(6) SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2017	2016
Fremdwährungsverluste	2.490	2.670
Sonstige Steuern	663	710
Zuführung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen	516	23
Verluste aus Anlagenabgängen	42	52
Aufwendungen aus Beendigung Mietvertrag	28	0
Sonstiges	46	33
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.785	3.488

Die Fremdwährungsverluste entstanden – wie im Vorjahr – im Wesentlichen aus Bewertungsänderungen von Kundenforderungen in US-Dollar aufgrund unterjährig veränderter Wechselkurse sowie aus Bewertungsänderungen von konzerninternen Verrechnungskonten in Fremdwährung.

(7) FINANZERGEBNIS

Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen sowie sonstigen Finanzaufwendungen und sonstigen Finanzerträgen zusammen.

Die Finanzerträge in Höhe von 57 Tsd. € (Vorjahr: 91 Tsd. €) resultierten im Wesentlichen aus Zinserträgen für Geldmarktanlagen und Wertpapiere.

Die Finanzaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

in Tsd. €	2017	2016
Zinsen für Bankverbindlichkeiten	153	676
Avalprovisionen	54	36
Sonstige Zins- und Finanzaufwendungen	0	8
Finanzaufwendungen	207	720

In den Zinsen für Bankverbindlichkeiten sind 151 Tsd. € (Vorjahr: 187 Tsd. €) enthalten, die auf die Grundstücksfinanzierung in Garching entfallen (Darlehensstand zum 31. Dezember 2017: 3.500 Tsd. €). Das Darlehen für die Grundstücksfinanzierung Sternenfels wurde im ersten Halbjahr 2016 gekündigt und zum 30. Juni 2016 komplett getilgt. Der damit verbundene Swap wurde aufgelöst. In den Zinsen für Bankverbindlichkeiten des Vorjahres sind 42 Tsd. € Zinsaufwendungen für die Grundstücksfinanzierung in Sternenfels sowie 434 Tsd. € für die Ablösung des damit verbundenen Swaps erfasst.

(8) ERTRAGSTEUERN

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellen sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2017	2016
Laufender Steueraufwand	5.442	5.347
Latenter Steuerertrag (-)/-aufwand (+)	1.605	170
davon auf temporäre Differenzen	1.440	-3
Gesamtaufwand	7.047	5.517

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand:

in %	2017	2016
Angenommener Steuersatz		
Körperschaftsteuer	15,00	15,00
Solidaritätszuschlag	5,50	5,50
Gewerbesteuer	12,43	12,43
Kombinierter Steuersatz	28,25	28,25

in Tsd. €	2017	2016
Ergebnis vor Steuern	13.753	10.519
Erwartete Ertragsteuern	3.885	2.972
Abweichende Steuersätze im Ausland	-298	-1.716
Mindestbesteuerung	5	35
Gewerbsteuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen	9	6
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	314	274
Steueraufwand Vorjahre	126	96
Nichtaktivierung / Wertberichtigung aktiver latenter Steuern	2.755	4.320
Inanspruchnahme wertberechtigter Verlustvorträge	0	-467
Steuerfreie Erträge	-67	-26
Sonstiges	318	23
Effektive Ertragsteuern	7.047	5.517

Die Gegenüberstellung der erwarteten zu den effektiven Ertragsteuern aus den fortgeführten Aktivitäten zeigt eine Abweichung von -3.162 Tsd. € (Vorjahr: -2.545 Tsd. €). Anstatt eines erwarteten Steueraufwands in Höhe von 3.885 Tsd. € ergab sich auf Konzernebene im Berichtsjahr ein Steueraufwand in Höhe von 7.047 Tsd. €.

Im Berichtsjahr wurden aktive latente Steuern in Höhe von 2.755 Tsd. € nicht angesetzt bzw. wertberichtigt. Davon betroffen waren vor allem temporäre Differenzen und Verlustvorträge der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, Kalifornien, USA. Die beiden US-Gesellschaften SUSS MicroTec, Inc. und SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. bilden eine „Tax-Group“, deren zu versteuerndes Einkommen in den USA der Gruppenbesteuerung unterliegt. Auf Basis der aktuellen Konzernplanung wird für die SUSS

MicroTec Photonic Systems in den nächsten drei Jahren ein negatives Ergebnis erwartet. Das Ergebnis der SUSS MicroTec, Inc. wird in den kommenden Jahren voraussichtlich leicht positiv sein.

Aus der im Dezember 2017 verabschiedeten Steuerreform in den USA, mit der die Steuersätze für amerikanische Unternehmen ab 2018 deutlich gesenkt wurden, ergeben sich keine Auswirkungen im Geschäftsjahr 2017. Für die in den USA vorhandenen Verlustvorräte und temporären Differenzen wurden keine latenten Steuern angesetzt. Somit resultiert aus der Änderung des US-Steuersatzes keine Neubewertung von latenten Steuern.

Es wurde keine Steuerabgrenzung auf nicht ausgeschüttete Gewinne von Tochtergesellschaften vorgenommen. Von einer Ermittlung der möglichen steuerlichen Auswirkungen wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands abgesehen.

Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

	Aktiva		Passiva	
	2017	2016	2017	2016
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0	132	187	0
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	954	1.183	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	62	3	0
Langfristige Rückstellungen	150	12	3	3
Immaterielle Vermögenswerte	505	1.071	0	0
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0	0	45	70
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	2.064	2.064
Passiver Ausgleichsposten SMT Photomask Equipment	0	0	220	250
Vorräte	1.460	1.927	0	0
Sachanlagen	12	9	0	0
Sonstiges	64	64	24	33
Verlustvorräte	114	165	0	0
Saldierung	-2.546	-2.420	-2.546	-2.420
Gesamt	714	2.205	0	0

Der Konzern verfügt über steuerliche Verlustvorräte in Höhe von 34.240 Tsd. € (Vorjahr: 49.770 Tsd. €). Davon verfallen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2027 insgesamt 7.220 Tsd. €. Im Zeitraum von 2028 bis 2037 verfallen insgesamt 27.020 Tsd. €. Verlustvorräte, die unbegrenzt nutzbar wären, sind nicht mehr vorhanden.

Im Mai 2017 hat die SÜSS MicroTec SE gegenüber der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA, einen Forderungsverzicht in Höhe von 15 Mio. USD ausgesprochen. Der daraus bei der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. resultierende Ertrag ist in den USA nicht steuerbar. Allerdings wurden die bestehenden Verlustvorräte um 15 Mio. USD gekürzt. Die dem Konzern zur Verfügung stehenden Verlustvorräte reduzierten sich dadurch in 2017 entsprechend.

Aus ihrem operativen Geschäft erzielte die SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. jedoch erneut ein deutlich negatives Jahresergebnis. Auch die SUSS MicroTec, Inc. (Corona / USA), die SUSS MicroTec Korea Company Ltd. (Hwaseong City / Korea) und die SUSS MicroTec KK (Yokohama / Japan) steuerten im abgelaufenen Geschäftsjahr Verluste zum Konzernergebnis bei. Die Gesellschaft SUSS MicroTec SARL, Frankreich, konnte hingegen erneut ein positives Jahresergebnis erreichen und dadurch die restlichen in Frankreich bestehenden Verlustvorräte nutzen.

Für Verlustvorräte in Höhe von 33.782 Tsd. € (Vorjahr: 49.074 Tsd. €) und temporäre Differenzen in Höhe von 17.143 Tsd. € (Vorjahr: 15.999 Tsd. €) wurden keine aktiven latenten Steuern angesetzt.

Nach IAS 12.74 f. ist eine Saldierung aktiver und passiver latenter Steuern vorzunehmen, wenn zum einen eine zivilrechtliche Aufrechnungslage gegeben ist, und zum anderen die latenten Steueransprüche und latenten Steuerschulden sich auf Ertragsteuern beziehen, die von der gleichen Steuerbehörde erhoben werden.

Zum 31. Dezember 2017 wurden somit aktive und passive latente Steuern in Höhe von 2.546 Tsd. € (Vorjahr: 2.420 Tsd. €) saldiert.

(9) ERGEBNIS JE AKTIE

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie zusammen:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Gewinn, der auf Aktionäre der SÜSS MicroTec AG entfällt	6.706	5.002
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien (Stück)	19.115.538	19.115.538
Effekt aus der (potenziellen) Ausübung von Aktienoptionen (Stück)	0	0
Angepasste gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (Stück)	19.115.538	19.115.538
Ergebnis je Aktie in € – unverwässert	0,35	0,26
Ergebnis je Aktie in € – verwässert	0,35	0,26

(10) SONSTIGE ANGABEN ZUR IFRS-KONZERN- GEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG

AUFWENDUNGEN FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Neben den in der Gewinn- und Verlustrechnung explizit ausgewiesenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sind im Geschäftsjahr auch Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten erfasst worden. Neuaktivierungen wurden in 2017 nicht vorgenommen.

Die Nettoinvestitionen und -aufwendungen für Forschung und Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	15.186	14.137
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten	61	74
Nettoinvestitionen	-61	-74

PERSONALAUFWAND

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS MicroTec-Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Löhne und Gehälter	53.009	52.508
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	6.832	6.914
Aufwendungen für Altersvorsorge	3.382	3.105
Personalaufwand	63.223	62.527

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Die Aufwendungen für Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplänen sowie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.

MATERIALAUFWAND

Die Materialaufwendungen betragen im Geschäftsjahr 2017 61.755 Tsd. € (Vorjahr: 55.734 Tsd. €).

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Immaterielle Vermögenswerte	1.244	1.290
Sachanlagen	2.830	2.860
Abschreibungen	4.074	4.150

Im Geschäftsjahr wurden Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Höhe von 921 Tsd. € (Vorjahr: 919 Tsd. €) und aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 61 Tsd. € (Vorjahr: 74 Tsd. €) abgeschrieben

Die im Rahmen der Erstkonsolidierung der SÜSS MicroTec Photonic Systems angesetzte Technologie und weitere erworbene immaterielle Vermögenswerte wurden mit 262 Tsd. € (Vorjahr: 297 Tsd. €) abgeschrieben.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN AKTIVA

Die folgenden Erläuterungen zur Konzernbilanz beinhalten für das Berichtsjahr ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Alle Angaben erfolgen – soweit nichts anderes angegeben ist – in Tsd. €.

(11) IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

Unter den immateriellen Vermögenswerten werden zum Stichtag neben Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten in Höhe von 1.903 Tsd. € (Vorjahr: 2.378 Tsd. €) Entwicklungsleistungen von 117 Tsd. € (Vorjahr: 178 Tsd. €) und die erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photonic Systems in Höhe von 589 Tsd. € (Vorjahr: 966 Tsd. €) ausgewiesen. Die Technologie wird planmäßig über acht Jahre abgeschrieben und weist eine verbleibende Restnutzungsdauer bis zum 31. März 2020 auf. In den Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten ist das konzernweite SAP-System enthalten.

Die aktivierten Entwicklungsleistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Maschinen. Der Restbuchwert zum 31. Dezember 2017 betrifft allein das Segment Lithografie.

Unter den anderen immateriellen Vermögenswerten wird die im Rahmen der Unternehmensakquisition der SUSS MicroTec Photonic Systems erworbene Technologie mit einem Restbuchwert von 589 Tsd. € (Vorjahr: 966 Tsd. €) ausgewiesen. Der Wert der Technologie wurde in US-Dollar erfasst und fortgeführt. Die Veränderung des Umrechnungskurses des US-Dollar im Vergleich zum Euro wirkte zum 31. Dezember 2017 wertmindernd.

(12) GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 15.573 Tsd. € (Vorjahr: 15.840 Tsd. €) entfällt in voller Höhe auf die Cash Generating Unit Lithografie. Ein Teil des Goodwills (2.366 Tsd. USD) wird in US-Dollar geführt und unterliegt daher Währungsschwankungen.

(13) SACHANLAGEN

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermögens sowie ihre Entwicklung im Berichts-

jahr sind im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

Zum 31. Dezember 2017 sind Immobilien mit einem Buchwert von 8.907 Tsd. € (9.048 Tsd. €) mit einer Grundschuld zur Sicherung von Bankdarlehen (siehe Textziffer 23) belastet.

(14) SONSTIGE (LANGFRISTIGE) VERMÖGENSWERTE

Die sonstigen langfristigen Vermögenswerte enthalten Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen, welche die Verrechnungskriterien mit bestehenden Pensionsrückstellungen nicht erfüllen, sowie geleistete Kautionen für angemietete Bürogebäude.

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Rückdeckungsversicherung	167	161
Kautionen	336	491
Sonstige langfristige Vermögenswerte	503	652

(15) VORRÄTE

Die Vorräte lassen sich wie folgt aufteilen:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Materialien und Hilfsstoffe	36.061	29.183
Unfertige Erzeugnisse	29.111	25.148
Fertigerzeugnisse	27.029	15.014
Demonstrationsgeräte	26.222	24.377
Handelswaren	743	870
Wertberichtigungen	-21.221	-20.788
Vorratsvermögen	97.945	73.804

Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2017 bilanzierten Vorräte in Höhe von 97.945 Tsd. € (Vorjahr: 73.804 Tsd. €) sind 37.314 Tsd. € (Vorjahr: 33.579 Tsd. €) zu ihrem Nettoveräußerungswert bilanziert.

Der Betrag der Vorräte, der im Geschäftsjahr als Aufwand erfasst wurde, beträgt rund 95.413 Tsd. € (Vorjahr: 108.779 Tsd. €).

(16) FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Forderungen gegen Dritte	20.517	24.507
Wertberichtigungen	-884	-396
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.633	24.111

Die folgende Tabelle gibt die Veränderungen in den Wertberichtigungen auf den Bestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wieder:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Wertberichtigungen zum Beginn des Geschäftsjahres	396	471
Ausbuchung von Forderungen	0	-4
Zahlungseingänge und Wertaufholungen auf ursprünglich abgeschriebene Forderungen	-28	-94
Zuführung	516	23
Wertberichtigungen zum Geschäftsjahresende	884	396

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind 4.991 Tsd. € (Vorjahr: 3.278 Tsd. €) überfällig, aber nicht wertgemindert. Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzern-Lagebericht.

(17) SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten von 483 Tsd. € (Vorjahr: 159 Tsd. €) sind im Wesentlichen positive Marktwerte von Devisentermingeschäften, Lieferantenboni und Forderungen gegenüber Mitarbeitern ausgewiesen.

(18) STEUERERSTATTUNGSANSPRÜCHE

Die kurzfristigen Steuerforderungen setzen sich wie folgt zusammen:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Geleistete Steuervorauszahlungen	83	208
Körperschaftsteuerguthaben der deutschen Gesellschaften	0	17
Steuerliche Zuschüsse	0	150
Steuererstattungsansprüche	83	375

(19) ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE

Bei den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 36.464 Tsd. € (Vorjahr: 35.621 Tsd. €) handelt es sich um Kassenbestände, Schecks sowie Guthaben bei Kreditinstituten, die innerhalb von drei Monaten vom Zeitpunkt der Einlage verfügbar sind. Die Veränderung zum Vorjahr wird in der Konzernkapitalflussrechnung dargestellt.

(20) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) VERMÖGENSWERTE

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten sind folgende Positionen enthalten:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Aktive Rechnungsabgrenzung	932	899
Geleistete Anzahlungen	645	563
Umsatzsteuer	2.776	1.109
Bietungsgarantien	50	105
Sonstiges	238	0
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	4.641	2.774

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, z. B. Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PASSIVA

(21) EIGENKAPITAL

GEZEICHNETES KAPITAL

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec SE betrug zum Bilanzstichtag unverändert 19.115.538,00 € (eingeteilt in 19.115.538 auf den Namen lautende und voll einbezahlte Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 €). Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapital-Veränderungsrechnung.

Jede Stückaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stückaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß handelsrechtlichem Jahresabschluss der SÜSS MicroTec SE ausgeschüttet werden.

Das genehmigte Kapital beträgt zum Bilanzstichtag 2.500 Tsd. € (Vorjahr: 2.500 Tsd. €).

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Grundkapital	19.116	19.116
Genehmigtes Kapital	2.500	2.500

RÜCKLAGEN

Die Rücklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Kapitalrücklage	71.547	71.547
Gewinnrücklage	202	433
Bilanzgewinn	38.537	31.831
Rücklagen	110.286	103.811

Die Gewinnrücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 231 Tsd. € reduziert, da aus der Neubewertung von Pensionen rund minus 231 Tsd. € vom sonstigen Ergebnis (OCI) in die Gewinnrücklage umgegliedert wurden.

Durch das positive Jahresergebnis des Konzerns von 6.706 Tsd. € hat sich der Bilanzgewinn auf 38.537 Tsd. € erhöht.

KUMULIERTES ÜBRIGES EIGENKAPITAL

Die Entwicklung des kumulierten übrigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	-3.013	-2.845
Fremdwährungsanpassungen	3.673	3.258
Absicherung künftiger Zahlungsströme	0	-410
Steuereffekte		
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	766	697
Absicherung künftiger Zahlungsströme	0	115
Stand zu Beginn der Periode	1.426	815
Veränderungen vor Steuern		
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	29	-168
Fremdwährungsanpassungen	-3.840	415
Absicherung künftiger Zahlungsströme	0	410
Steuereffekte		
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	-30	69
Absicherung künftiger Zahlungsströme	0	-115
Stand am Ende der Periode	-2.415	1.426

Die damalige SÜSS MicroTec AG hat 2010 einen Zinsswap als Sicherungsinstrument für das variabel verzinsliche Darlehen, das der Finanzierung des neu erworbenen Grundstücks in Sternenfels dient, abgeschlossen. Für diesen Zinsswap wurde Hedge-Accounting angewendet: Anstelle der Abbildung in der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Marktwertänderungen im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet. Im ersten Halbjahr 2016 wurde das Darlehen vorzeitig abgelöst und komplett getilgt. Der Swap wurde im April 2016 glattgestellt. Der in den Vorjahren im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildete Betrag in Höhe von -410 Tsd. €, der die Marktwertänderungen des Swaps widerspiegelte, wurde in 2016 ergebniswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung im Finanzergebnis erfasst. Gleichzeitig wurden in 2016 die damit verbundenen latenten Steuern in Höhe von 115 Tsd. € in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.

EIGENKAPITALMANAGEMENT

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns – bestehend aus dem gezeichneten Kapital, den Rücklagen und dem kumulierten übrigen Eigenkapital – beläuft sich zum 31. Dezember 2017 auf insgesamt 126.987 Tsd. € (Vorjahr: 124.353 Tsd. €); das entspricht einer Eigenkapitalquote von 62,9% (Vorjahr: 69,2%). Neben einer angemessenen Eigenkapitalrentabilität strebt der SÜSS MicroTec-Konzern eine nachhaltig hohe Eigenkapitalquote sowie eine hohe Liquiditätsreserve an, um künftiges Wachstum sicherzustellen und den Unternehmenswert zu steigern. Zur Aufrechterhaltung oder Anpassung der Kapitalstruktur kann der Konzern alle Möglichkeiten nutzen, die die Börsennotierung der SÜSS MicroTec SE mit sich bringt.

Der Vorstand der Gesellschaft geht nach derzeitigem Planungsstand davon aus, im kommenden Geschäftsjahr ein positives Ergebnis zu erzielen. Bei einer deutlichen Verfehlung der Planung besteht die Gefahr, dass sich das Eigenkapital infolge eines Jahresfehlbetrags verringern könnte.

(22) PENSIONEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN

Das Unternehmen gewährt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität berücksichtigen. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich in der Regel auf Basis der Gehälter und der Dauer der Betriebszugehörigkeit der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungszusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfüllen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen geht der Konzern über die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Rückstellungen werden hier nicht gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2017	2016
Barwert der Pensionsverpflichtungen	10.070	9.431
Zeitwert des Planvermögens	-5.324	-4.594
Errechnete Pensionsverbindlichkeit	4.746	4.837

LEISTUNGSORIENTIERTE PLÄNE („DEFINED BENEFIT PLANS“)

Der Konzern verfügt in Deutschland, Japan und in der Schweiz über leistungsorientierte Pensionspläne.

Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutschland umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

in %	2017	2016
Abzinsungssatz	1,45	1,43
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	1,45	1,43
Gehaltssteigerung	0,00	0,00
Rentensteigerung	2,00	2,00

Lebenserwartung gem. Richttafeln Dr. Heubeck 2005 G

Beim Gehalt wurden keine Steigerungsraten berücksichtigt, da in den deutschen Plänen keine aktiven Anwärter mehr enthalten sind.

Die Pensionszusagen der Tochtergesellschaft in der Schweiz umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet in Abhängigkeit vom Grundgehalt. Anspruchsberechtigt sind alle Angestellten und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

in %	2017	2016
Abzinsungssatz	0,70	0,65
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	0,70	0,65
Gehaltssteigerung	1,50	1,50
Rentensteigerung	0,00	0,00

Die Tochtergesellschaft in Japan verfügt über einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan, aus dem bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Höhe der Pensionszahlung richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht für jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung von 80 % eines Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr vor. Anspruchsberechtigt ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer Betriebszugehörigkeit von mindestens drei Jahren.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

in %	2017	2016
Abzinsungssatz	0,20	0,00
Gehaltssteigerung	1,99	2,36
Rentensteigerung	0,00	0,00

Die Anwartschaftsbarwerte der Versorgungsverpflichtungen und beizulegenden Zeitwerte des Planvermögens haben sich in den Geschäftsjahren 2017 und 2016 wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	2017	2016
Anwartschaftsbarwert am 1.1.	9.431	9.003
Dienstzeitaufwand	444	633
Zinsaufwand	78	107
Pensionszahlungen	1.149	-554
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn/ (+) Verlust aus Veränderungen der finanziellen Annahmen	-76	308
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn/ (+) Verlust aus Veränderungen der demographischen Annahmen	0	-461
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn/ (+) Verlust aus erfahrungsbedingten Anpassungen	-442	309
Währungsveränderungen	-514	86
Anwartschaftsbarwert am 31.12.	10.070	9.431

in Tsd. €	2017	2016
Planvermögen am 1.1.	4.594	3.859
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	33	42
Geleistete Fondsdotierungen	1.735	634
Versicherungsmathematischer (+) Gewinn/(-) Verlust	-729	38
Währungsveränderungen	-309	21
Planvermögen am 31.12.	5.324	4.594

Die wesentlichen Komponenten des Planvermögens sind Rückdeckungsversicherungen. Im Zusammenhang mit den Pensionsverpflichtungen in Deutschland wurden entsprechende Rückdeckungsversicherungen bei der Allianz Lebensversicherungs-AG abgeschlossen. Die Pensionsverpflichtungen in der Schweiz sind über die Helvetia Sammelstiftung abgesichert, die hierfür entsprechende Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen hat. Die beiden Rückdeckungsversicherungen sind als konservative,

risikoarme Anlageform zu sehen, deren Wert nur geringen Marktschwankungen unterliegt.

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entfällt in Höhe von 8.033 Tsd. € (Vorjahr: 6.841 Tsd. €) auf fondsfinanzierte Versorgungsansprüche.

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

in Tsd. €	2017	2016
Dienstzeitaufwand	444	633
Personalaufwandskomponente	444	633
Zinsaufwand	78	107
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	-10	-14
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	-15	-4
Zinsaufwandskomponente	53	89

Für 2018 erwartet der Konzern zur Erfüllung der Pensionsverpflichtungen Zahlungsmittelabflüsse von insgesamt 442 Tsd. €. In der folgenden Übersicht wird aufgezeigt, in welcher Weise der Barwert aller definierten Leistungsverpflichtungen durch Veränderungen der maßgeblichen versicherungsmathematischen Annahmen beeinflusst worden wäre:

in Tsd. €	2017	2016
Veränderung des Barwerts aller definierten Leistungsverpflichtungen, falls		
der Abzinsungssatz 50 Basispunkte niedriger wäre	817	741
der Abzinsungssatz 50 Basispunkte höher wäre	-702	-639
die Lohnsteigerung 50 Basispunkte niedriger wäre	-135	-128
die Lohnsteigerung 50 Basispunkte höher wäre	132	130
die künftige Rentensteigerung 0,50% niedriger wäre	-438	-400
die künftige Rentensteigerung 0,50% höher wäre	483	440

BEITRAGSORIENTIERTE PLÄNE („DEFINED CONTRIBUTION PLANS“)

Der Konzern hat für seine Mitarbeiter in den USA einen „Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Von dem Plan profitieren alle Mitarbeiter der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, und der SUSS MicroTec, Inc., Corona, ab einem Alter von 18 bzw. 21 Jahren und einem Minimum an geleisteten Arbeitsstunden von 1.000 Stunden pro Jahr. Sämtliche Beiträge der beiden US-Unternehmen werden in einem „Trust-Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren.

Die beiden 401-(k)-Pläne bieten den Mitarbeitern die Möglichkeit, einen bestimmten Anteil ihrer jährlichen Vergütung in den 401-(k)-Plan einzubezahlen. Der maximal mögliche Betrag bestimmt sich durch das vom IRS vorgegebene Limit, das sich für 2017 auf 18.000 USD belief. Ab einem Alter von 50 Jahren können Mitarbeiter darüber hinaus weitere 6.000 USD einzahlen.

Der Arbeitgeber leistet ebenfalls Beiträge zu den 401-(k)-Plänen. Für jeden 1,00 USD, der vom Arbeitnehmer in den 401-(k)-Plan einbezahlt wird, steuert der Arbeitgeber 1,00 USD als Beitrag bei. Der Arbeitgeber beteiligt sich bis zu einer Beitragshöhe von maximal 3 % des Arbeitnehmer-Gehalts am Altersvorsorgeplan.

Im Geschäftsjahr 2017 betragen die Aufwendungen des Konzerns für den 401-(k)-Plan 241 Tsd. USD (Vorjahr: 172 Tsd. USD).

Weiterhin wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von 3.169 Tsd. € (Vorjahr: 2.949 Tsd. €) abgeführt.

(23) FINANZSCHULDEN

Die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ergibt sich zum 31. Dezember 2017 bzw. zum Vorjahresstichtag wie folgt:

31.12.2017 in Tsd. €	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000	2.500	0	3.500
Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5	0	0	5
Gesamt	1.005	2.500	0	3.505

31.12.2016 in Tsd. €	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000	3.500	0	4.500
Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7	0	0	7
Gesamt	1.007	3.500	0	4.507

VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus einem langfristigen Darlehensvertrag, der der Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Garching dient.

Der Darlehensvertrag für die Grundstücksfinanzierung Garching wurde am 23./28. Oktober 2013 zwischen der SÜSS MicroTec SE und einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021 und weist einen fixen Zinssatz von 3,65% auf. Es wurde am 16. Dezember 2013 valuiert und zur Auszahlung gebracht. Das Darlehen ist mit Grundschulden auf das Betriebsgrundstück in Garching besichert; der Buchwert des Grundstücks und der Gebäude beläuft sich zum 31.12.2017 auf 8.907 Tsd. € (Vorjahr: 9.048 Tsd. €). Die Restschuld aus diesem Darlehen beläuft sich zum 31. Dezember 2017 auf 3.500 Tsd. € (Vorjahr: 4.500 Tsd. €).

Im Einzelnen setzen sich die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres wie folgt zusammen:

Konzerngesellschaft in Tsd. €	2017	2016	Zinssatz	Fälligkeit
SÜSS MicroTec SE	3.500	4.500	3,65 %	30.6.2021
Gesamt	3.500	4.500		
davon kurzfristig fällig	1.000	1.000		
davon langfristig fällig	2.500	3.500		
2018	1.000			
2019	1.000			
2020	1.000			
2021	500			
	3.500			

Die Gesellschaft verfügt über diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	2017	2016
Kredit- / Avallinie	8.250	5.250
Inanspruchnahme in Form von Avalen	3.443	2.764
Verfügbare Kredit- / Avallinie	4.807	2.486

Die Deutsche Bank AG, die DZ Bank AG und die Baden-Württembergische Bank stellten zum Geschäftsjahresende Kredit- und Avallinien in Höhe von insgesamt 7,5 Mio. €. Davon waren Avallinien von 3,0 Mio. € befristet bis zum 31.12.2017. Diese zusätzlichen Linien wurden SÜSS MicroTec vorübergehend gewährt, um diversen Kunden die gewünschten Anzahlungsgarantien stellen zu können. Seit 1. Januar 2018 belaufen sich die Kredit- und Avallinien, die von den drei Banken gestellt werden, auf insgesamt 4,5 Mio. €. Diese Linien werden über bilaterale Kreditverträge bis auf weiteres gewährt und wurden ohne Covenants gestellt. Die Linien können von der SÜSS MicroTec SE oder der SÜSS MicroTec Lithography GmbH in Anspruch genommen werden.

Die BW-Bank Mannheim gewährt der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG eine Kredit- und Avallinie in Höhe von 750 Tsd. €. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt.

Zum Bilanzstichtag sind die Linien in Höhe von 3.443 Tsd. € (Vorjahr: 2.764 Tsd. €) in Form von Avalen genutzt.

Der durchschnittliche Zinssatz für die Inanspruchnahme der Kreditlinien in Form von Avalen betrug 1,11% (Vorjahr: 1,11%).

VERBINDLICHKEITEN AUS FINANCE-LEASE

Der Konzern least derzeit diverse Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände sowohl im Fertigungs- als auch im Verwaltungsbereich unter Operating-Lease-Verträgen. Finance-Lease-Verträge, deren zugrunde liegende Vermögenswerte aktiviert und planmäßig abgeschrieben werden, bestehen nicht mehr.

Die finanziellen Verpflichtungen aus Operating-Lease stellen sich wie folgt dar:

<i>in Tsd. €</i>	Finance Lease	Operating Lease
Abschreibungen / Aufwendungen 2017	0	1.102
Abschreibungen / Aufwendungen 2016	7	1.121
Künftige Verpflichtungen		
fällig in 2018	0	833
2019	0	288
2020	0	131
2021	0	32
2022	0	3
später	0	0
Gesamt zukünftig	0	1.287

(24) (KURZFRISTIGE) RÜCKSTELLUNGEN

Die kurzfristigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Garantierückstellungen	2.058	2.522
Rückstellung für die Abfindung eines Vorstandsmitglieds	0	750
Rückstellung für die Neuausrichtung Vertrieb Japan	0	1.205
Übrige Rückstellungen	601	684
Kurzfristige Rückstellungen	2.659	5.161

Die Garantierückstellungen wurden für gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche von Kunden aus Maschinenlieferungen in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Rückstellung für die Neuausrichtung des Vertriebs in Japan enthielt im Vorjahr Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern, die SÜSS MicroTec verlassen werden, in Höhe von rund 926 Tsd. €. Diese Mitarbeiter hatten Anspruch auf Auszahlung ihrer angesparten Altersbezüge und auf Auszahlung von Abfindungen. Die Abfindungsbeträge beliefen sich auf rund 276 Tsd. € und wurden im Vorjahr aufwandswirksam erfasst. Für die Altersbezüge wurden bereits in den Vorjahren kontinuierlich Pensionsrückstellungen gebildet. Zum 31. Dezember 2016 wurden davon rund 650 Tsd. € in die kurzfristigen sonstigen Rückstellungen umgebucht. Im Zusammenhang mit der Neuorganisation des Vertriebs in Japan wurden darüber hinaus im Vorjahr Rückstellungen in Höhe von rund 279 Tsd. € gebildet für den Rückbau der von der SÜSS MicroTec KK bisher angemieteten Räumlichkeiten sowie für ausstehende Mietverpflichtungen.

Die übrigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Nachlaufkosten sowie Personalrückstellungen.

Die kurzfristigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

<i>in Tsd. €</i>	Stand 01.01.2017	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
Garantierückstellungen	2.522	-2.522	0	2.058	2.058
Abfindungen	750	-750	0	0	0
Rückstellung für die Neuausrichtung Vertrieb Japan	1.205	-1.205	0	0	0
Übrige Rückstellungen	684	-678	-6	601	601
Kurzfristige Rückstellungen	5.161	-5.155	-6	2.659	2.659

(25) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Prämien und Provisionen	3.465	2.607
Fremdleistungen	1.599	1.538
Aufsichtsratsvergütung	70	203
Devisentermingeschäfte	0	289
Noch abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	978	509
Lizenzgebühren	328	26
Kreditorische Debitoren	235	138
Sonstiges	73	49
Sonstige (kurzfristige) finanzielle Verbindlichkeiten	6.748	5.359

(26) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Erhaltene Anzahlungen	40.312	22.600
Abgegrenzte Personalkosten	3.981	4.555
Passive Rechnungsabgrenzung	1.113	443
Umsatzsteuer	858	127
Sonstiges	170	501
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	46.434	28.226

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen für Maschinen vor der endgültigen Abnahme. Nach erfolgter Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet.

In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen für Urlaubsrückstände und Gleitzeitguthaben enthalten.

(27) STEUERSCHULDEN

Die Steuerverbindlichkeiten enthalten inländische Ertragsteuern in Höhe von 3.053 Tsd. € (Vorjahr: 2.873 Tsd. €) und ausländische Ertragsteuern in Höhe von 529 Tsd. € (Vorjahr: 948 Tsd. €).

SONSTIGE ANGABEN

(28) ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ÜBER FINANZINSTRUMENTE

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsätzlich sämtliche auf vertraglicher Basis vorgenommenen wirtschaftlichen Vorgänge, die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehören einerseits originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andererseits Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die Finanzinstrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Währungs- und Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden. Die geschätzten Marktwerte der Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde. Folgender Abschnitt gibt einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Finanzinstrumenten für das Unternehmen und liefert zusätzliche Informationen über Bilanzpositionen, die Finanzinstrumente enthalten.

Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte aller Kategorien von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Finanzielle Vermögenswerte		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	36.464	35.621
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	0	0
Kredite und Forderungen	20.015	24.270
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	101	0
	56.580	59.891
Finanzielle Verbindlichkeiten		
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten	0	289
Finanzielle Verbindlichkeiten	17.542	12.939
	17.542	13.228

Die folgende Tabelle stellt die Marktwerte sowie die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dar:

<i>in Tsd. €</i>	2017		Bewertungskategorien gem. IFRS 7
	Buchwert	Marktwert	
Finanzielle Vermögenswerte			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	36.464	36.464	Kredite und Forderungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.633	19.633	Kredite und Forderungen
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	483	483	Kredite und Forderungen
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	382	382	Kredite und Forderungen
bewertet zum Marktwert (Fair Value, Stufe 2)	101	101	Handelsbestand
Wertpapiere, bewertet zum Marktwert	0	0	zur Veräußerung verfügbar
Finanzielle Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.289	7.289	Fortgeführte Anschaffungskosten
Finanzschulden	3.505	3.761	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.505	3.761	Fortgeführte Anschaffungskosten
Verbindlichkeiten aus Finance-Lease	0	0	Fortgeführte Anschaffungskosten
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	6.748	6.748	
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	6.748	6.748	Fortgeführte Anschaffungskosten
bewertet zum Marktwert (Fair Value, Stufe 2)	0	0	Handelsbestand

in Tsd. €	2016		Bewertungskategorien gem. IFRS 7
	Buchwert	Marktwert	
Finanzielle Vermögenswerte			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	35.621	35.621	Kredite und Forderungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.111	24.111	Kredite und Forderungen
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	159	159	Kredite und Forderungen
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	159	159	Kredite und Forderungen
bewertet zum Marktwert (Fair Value, Stufe 2)	0	0	Handelsbestand
Wertpapiere, bewertet zum Marktwert	0	0	zur Veräußerung verfügbar
Finanzielle Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.362	3.362	Fortgeführte Anschaffungskosten
Finanzschulden	4.507	4.947	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.507	4.947	Fortgeführte Anschaffungskosten
Verbindlichkeiten aus Finance-Lease	0	0	Fortgeführte Anschaffungskosten
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	5.359	5.359	
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	5.070	5.070	Fortgeführte Anschaffungskosten
bewertet zum Marktwert (Fair Value, Stufe 2)	289	289	Handelsbestand

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

Sonstige finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten

Die Buchwerte der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in etwa dem Marktwert.

Die Bewertung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Marktwerten bewertet werden, hängt von ihrem Typ ab. Der Marktwert von Devisentermingeschäften bestimmt sich in Abhängigkeit von Devisenterminkursen. Der Marktwert von Zinsderivaten bestimmt sich durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme über die Restlaufzeit des Kontrakts auf der Basis aktueller Marktzinsen und der Zinsstrukturkurve.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Nettogewinne bzw. -verluste aus Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

<i>in Tsd. €</i>	2017	2016
Kredite und Forderungen	-488	71
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	0	0

Nettogewinne bzw. -verluste aus Krediten und Forderungen enthalten Veränderungen in den Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung sowie Zahlungseingänge auf ursprünglich abgeschriebene Darlehen und Forderungen.

DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen und Zinsrisiken zu begrenzen.

Die direkten Marktwerte der einzelnen Arten von derivativen Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

<i>in Tsd. €</i>	2017		2016	
	Positiver Marktwert	Negativer Marktwert	Positiver Marktwert	Negativer Marktwert
Devisentermingeschäfte	101	0	0	289

Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den SÜSS MicroTec-Gesellschaften aus dem Euroraum und externen Kunden oder Lieferanten, die nicht im Euroraum ansässig sind. Dies betrifft vor allem Kunden oder Lieferanten in den Währungsräumen des US-Dollar und des japanischen Yen, die Produkte von SÜSS MicroTec-Gesellschaften aus dem Euro-Währungsraum beziehen oder an diese verkaufen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrags werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen. Die Veränderung der Marktwerte weist das Unternehmen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Die potenziellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

Zum 31. Dezember 2017 bestehen vier offene Devisentermingeschäfte über den Terminverkauf von insgesamt 9,2 Mio. USD. Diese Devisentermingeschäfte weisen folgende Parameter auf:

Gesicherter Betrag <i>in Tsd. €</i>	Valutadatum	Sicherungskurs
4.000	30.04.18	1,1941 USD / €
2.400	31.05.18	1,1960 USD / €
1.200	29.06.18	1,1981 USD / €
1.600	31.08.18	1,2036 USD / €

Die Fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation der Fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts und des Konzern-Treasury ermittelt. Dabei werden die Fremdwährungsrisiken durch Simulation einer zehnprozentigen Abwertung aller Fremdwährungen gegenüber dem Euro berechnet. Diese simulierte Abwertung hätte zum Bilanzstichtag zu einer Reduzierung der Euro-Gegenwerte in Höhe von 814 Tsd. € (Vorjahr: Reduzierung um 1.064 Tsd. €) und einer entsprechenden Verringerung (Vorjahr: Verringerung) des Jahresergebnisses geführt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremdwährungs-Exposures und die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag:

<i>in Tsd. €</i>	2017		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.774	2.158	5.932
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.957	1.035	3.992
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-598	-368	-966
Netto-Exposure	6.133	2.825	8.958
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro	-558	-257	-814

<i>in Tsd. €</i>	2016		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.572	2.110	7.682
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.519	2.278	4.797
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-401	-374	-775
Netto-Exposure	7.690	4.014	11.704
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro	-699	-365	-1.064

(29) NAHESTEHENDE PERSONEN

Nach IAS 24 müssen Personen angegeben werden, die die SÜSS MicroTec SE beherrschen oder von ihr beherrscht werden, soweit sie nicht bereits in den Konzernabschluss einbezogen wurden.

Beherrschung liegt vor, wenn ein Aktionär mehr als die Hälfte der Stimmrechte der SÜSS MicroTec SE hält oder kraft Satzung oder vertraglicher Vereinbarung die Möglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec SE zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit Joint Ventures sowie auf Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec SE ausüben, einschließlich naher Familienangehöriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des Konzerns kann hierbei auf einem Anteilsbesitz an der SÜSS MicroTec SE von 20% oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Im Geschäftsjahr wurde der Konzern von den Angabepflichten nach IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen“ – mit Ausnahme der Angaben zur Vergütung der Organe – nicht berührt.

(30) FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2017	2016
Bestellobligo	36.783	24.996
Miet- und Leasingverpflichtungen	1.172	1.864
Summe	37.955	26.860

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

(31) ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

In der Konzernkapitalflussrechnung des SÜSS MicroTec-Konzerns wird entsprechend IAS 7 („Cashflow Statements“) zwischen Zahlungsströmen aus betrieblicher Geschäftstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d. h. Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten,

soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.

Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Währungsumrechnung bereinigt. Die Veränderungen der betreffenden Bilanzpositionen können daher nicht mit den entsprechenden Werten auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Höhe von -228 Tsd. € (Vorjahr: 619 Tsd. €) beinhalten im Wesentlichen Währungseffekte. Im Vorjahr waren hier außerdem die Effekte aus der Zuführung zu einer Rückstellung für Abfindungen in Höhe von 750 Tsd. € enthalten.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zeigt mit -1.000 Tsd. € die planmäßige Tilgung des Bankdarlehens, das der Finanzierung des Grundstücks Garching dient. Die Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten spiegelt die stichtagsbedingte Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten wider. Fair-Value-Änderungen oder Wechselkurseffekte waren im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht zu verzeichnen.

(32) SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

INFORMATIONEN ZU DEN SEGMENTEN

Die Aktivitäten des SÜSS MicroTec-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gemäß den Regeln von IFRS 8 („Operating Segments“) nach Produktlinien und nach Regionen abgegrenzt. Diese Aufgliederung orientiert sich an der internen Steuerung und Berichterstattung an den Vorstand und berücksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertragsstrukturen der Segmente.

Die Aktivitäten des SÜSS MicroTec-Konzerns werden in die operativen Segmente Lithografie, Bonder und Fotomaschinen-Equipment aufgeteilt. Im Segment Sonstige werden weitere Aktivitäten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen gebündelt.

Im Segment Lithografie entwickelt, produziert und vertreibt der SÜSS MicroTec-Konzern die Produktlinien Mask-Aligner, Entwickler und Belacker sowie die Produktlinien UV-Projection und Laser-Processing. Die Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Die Entwicklung und Produktion der Produktlinien UV-Projection und Laser-Processing erfolgen in Corona, USA. Darüber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für das Segment Lithografie tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als

die Hälfte des Gesamtgeschäfts der Gruppe dar und ist in den Märkten Advanced Packaging, MEMS und Verbindungshalbleiter vertreten.

Im Segment Bonder sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Bonder ausgewiesen. Die Aktivitäten in diesem Segment sind in Sternenfels bei Stuttgart konzentriert. Der Vertrieb für das Segment Bonder ist über Sternenfels hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa, in den USA und in Asien ansässig.

Das Segment Fotomaschinen-Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien HMX, ASX, MaskTrack und MaskTrack Pro der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG. Die Entwicklung und Produktion der auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomaschinen für die Halbleiter-Industrie spezialisierten Systeme ist am Standort Sternenfels angesiedelt.

SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN ZUR SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ermittelt. Infolge der gesellschaftsübergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsätzlich keine wesentlichen intersegmentären Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SÜSS MicroTec SE, die im Segment Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente für die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs- und Strategiefragen. Diese Weiterbelastungen enthalten auch die in der Holding angefallenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Systembetrieb von SAP.

Um den Anforderungen des IFRS 8 „Segmentberichterstattung“ zu entsprechen, enthält die Segmentberichterstattung die Angabe eines Vorsteuerergebnisses je Segment. Damit ist die Überleitung der Summe der Segmentergebnisse zum Gesamtkonzernergebnis vor Steuern möglich.

Im Geschäftsjahr hat SÜSS MicroTec mit keinem Kunden Umsätze erzielt, die einen Anteil von mehr als 10 % am gesamten Konzernumsatz darstellten. Im Vorjahr waren mit zwei Kunden Umsätze zu verzeichnen, die jeweils einen Anteil von mehr als 10 % am gesamten Konzernumsatz darstellten. Auf einen Kunden entfielen dabei rund 22,6 Mio. €, mit dem anderen Kunden wurden Umsätze von rund 25,3 Mio. € erzielt.

Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen werden neben den Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Abwertungen auf das Vorratsvermögen auch die Zuführung zu und die Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Verpflichtungen gezeigt.

Das Segmentvermögen stellt das betriebsnotwendige Vermögen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Vermögenswerte inklusive Geschäfts- oder Firmenwert, die

Sachanlagen sowie das Vorratsvermögen und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Rückstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen.

Für die geografische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlöse nach dem Standort der Kunden segmentiert. SÜSS MicroTec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von 24.503 Tsd. € (Vorjahr: 15.532 Tsd. €) in Deutschland erzielt.

Das Vermögen und die Investitionen wurden auf der Grundlage des Standorts der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt. Das langfristige Vermögen des Konzerns besteht im Wesentlichen aus immateriellen Vermögenswerten, Geschäfts- oder Firmenwerten und Sachanlagen. Vom langfristigen Vermögen sind 33.530 Tsd. € (Vorjahr: 32.216 Tsd. €) Gesellschaften in Deutschland zuzurechnen; 7.955 Tsd. € (Vorjahr: 7.709 Tsd. €) entfallen auf ausländische Gesellschaften. Der SÜSS MicroTec-Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von 3.557 Tsd. € (Vorjahr: 1.934 Tsd. €) in Deutschland vorgenommen.

(33) NACHTRAGSBERICHT

Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag, die einen signifikanten Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns haben, haben sich nicht ergeben.

(34) VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

VORSTAND DER KONZERNBEREITSCHAFT

Die zum Zeitpunkt des Formwechsels bei der SÜSS MicroTec AG bestellten Vorstände Herr Dr. Richter und Herr Braun wurden vom Aufsichtsrat mit Beschluss vom 31. Mai 2017 auch zu Vorständen der SÜSS MicroTec SE bestellt. Herr Leurs wurde mit Wirkung zum 1. Dezember 2017 als weiterer Vorstand bestellt.

Mitglieder des Vorstandes der SÜSS MicroTec SE im Geschäftsjahr 2017 waren:

Dr. Franz Richter

- Dr.-Ing., Eichenau,
Vorstandsvorsitzender

Zuständigkeitsbereiche:

Marketing und Vertrieb, Konzernstrategie, Service, Forschung und Entwicklung, Patentwesen, Divisions/Produktlinien, Personal

Weitere Mandate:

- Siltronic AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats)
- Meyer Burger Technology AG, Gwatt, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)

- COMET Holding AG, Flamatt, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)
- Scint-X AB, Stockholm, Schweden
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Robert Leurs (seit 1. Dezember 2017)

- Diplom-Kaufmann, Diplom-Finanzwirt, Stockdorf,
Finanzvorstand

Zuständigkeitsbereiche:

Finanz- und Rechnungswesen, IT, Recht, Steuern und Versicherungen, Facility Management, Investor Relations

Weitere Mandate: keine

Walter Braun

- Diplom-Ingenieur, Altensteig,
Produktionsvorstand

Zuständigkeitsbereiche:

Produktion, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Umweltschutz, Materialwirtschaft und Logistik

Weitere Mandate: keine

Michael Knopp (bis 30. April 2017)

- Diplom-Kaufmann, Ratingen,
Finanzvorstand

Zuständigkeitsbereiche:

Finanz- und Rechnungswesen, IT, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal, Facility Management, Investor Relations

Weitere Mandate: keine

AUFSICHTSRAT

In der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 wurde der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG neu gewählt und auf vier Mitglieder erweitert. Als viertes Mitglied wurde Frau Dr. Myriam Jahn in den Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG gewählt. Der unter aufschiebender Bedingung der Handelsregistereintragung des Formwechsels am 31. Mai 2017 von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE nahm seine Tätigkeit mit Wirksamkeit des Formwechsels zum 9. August 2017 auf. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates blieb unverändert.

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2017

waren:

Dr. Stefan Reineck

- Kirchart, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchart; Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec SE

Weitere Mandate:

- attoCube Systems AG, München
(Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA
(Mitglied im Board of Directors)
- Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)

Jan Teichert

- Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau, Isar; stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec SE

Weitere Mandate: keine

Gerhard Pegam

- Au/Bad Feilnbach, Geschäftsführender Gesellschafter der GPA Consulting, Au/Bad Feilnbach; Aufsichtsratsmitglied der SÜSS MicroTec SE

Weitere Mandate:

- OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz
(Stellvertretender Verwaltungsratspräsident)
- Schaffner Holding AG, Solothurn, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)

Dr. Myriam Jahn (seit 31. Mai 2017)

- Düsseldorf, Mitglied des Vorstands der TISC AG, Siegen, Aufsichtsratsmitglied der SÜSS MicroTec SE

Weitere Mandate: keine

VERGÜTUNG VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Die Mitglieder des Vorstands erhielten eine Barvergütung in Höhe von 1.285 Tsd. € (Vorjahr: 2.153 Tsd. €). Der Betrag der Vorstandsvergütung des Vorjahres enthielt eine Abfindung in Höhe von 750 Tsd. € für den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, Dr. Per-Ove Hansson, der am 26. August 2016 ausgeschieden ist.

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug einschließlich Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen 231 Tsd. € (Vorjahr: 203 Tsd. €).

Individualisierte Angaben zur Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats sind im Vergütungsbericht, der Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts ist, dargestellt.

Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum Jahresende:

	2017		2016	
	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
Dr. Franz Richter	65.000	0	60.000	0
Robert Leurs	0	0	0	0
Walter Braun	10.120	0	18.300	0
Michael Knopp	0	0	19.900	0
Dr. Per-Ove Hansson	0	0	4.000	0
Dr. Stefan Reineck	9.600	0	9.600	0

(35) MITARBEITER

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 739 Mitarbeiter (Vorjahr: 713 Mitarbeiter) in der SÜSS MicroTec-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

	2017	2016
Verwaltung	70	68
Marketing und Vertrieb	271	262
Produktion und Technik	438	381
Summe	779	711

(36) HONORARE DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Im aktuellen Geschäftsjahr hat SÜSS MicroTec für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Honoraraufwendungen nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB in Höhe von 274 Tsd. € (Vorjahr: 251 Tsd. €) erfasst. Auf Netzwerkpartner des Konzernabschlussprüfers (weitere Mitglieder von BDO International) entfielen im Geschäftsjahr Honoraraufwendungen von 11 Tsd. € (Vorjahr: 9 Tsd. €). Die Aufwendungen für Abschlussprüfung beliefen sich auf 256 Tsd. € und umfassten auch Aufwendungen für freiwillige Abschlussprüfungen bei den deutschen Tochtergesellschaften, für Prüfungsleistungen im Zusammenhang mit der zukünftigen Umstellung auf IFRS 15 und der Sonderprüfung der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung. Des Weiteren wurden im Geschäftsjahr rund 18 Tsd. € für andere Bestätigungsleistungen aufgewendet (Reinvermögensprüfung für die Umwandlung der SÜSS MicroTec AG in die SÜSS MicroTec SE). Im Vorjahr betrafen sämtliche Aufwendungen ausschließlich die Abschlussprüfung.

Die Aufwendungen für die Abschlussprüfung enthalten das gesamte Honorar für die Jahresabschlussprüfung der SÜSS MicroTec SE sowie die Konzernabschlussprüfung und die durch BDO geprüften Jahresabschlüsse von Tochtergesellschaften. Vom Honorar für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses entfallen rund 30 Tsd. € (Vorjahr: 30 Tsd. €) auf die Prüfung des Einzelabschlusses der SÜSS MicroTec SE.

(37) CORPORATE GOVERNANCE

Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat im Januar 2017 eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 5. Mai 2015 mit folgenden Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, vertikaler Vergütungsvergleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschüssen und Festlegung einer Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer im Aufsichtsrat – entsprechen werden und den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 5. Mai 2015 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Januar 2016 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen haben.

Im Januar 2018 haben Vorstand und Aufsichtsrat eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 mit folgenden Ausnahmen – Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen, vertikaler Vergütungsvergleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschüssen und Festlegung einer Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer im Aufsichtsrat – entsprechen werden. Ferner haben Vorstand und Aufsichtsrat erklärt, dass sie den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Januar 2017 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen haben.

Die Entsprechenserklärungen wurden im Internet unter > www.suss.com dauerhaft zugänglich gemacht.

(38)

FREIGABE DES ABSCHLUSSES

Der Vorstand der SÜSS MicroTec SE hat den IFRS-Konzernabschluss am 9. März 2018 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben.

Garching, 9. März 2018
Der Vorstand



Dr. Franz Richter
Vorstandsvorsitzender



Robert Leurs
Finanzvorstand



Walter Braun
Produktionsvorstand

VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der SÜSS MicroTec SE zusammengefasst ist, der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Garching, den 9. März 2018

SÜSS MicroTec SE
Der Vorstand



Dr. Franz Richter
Vorstandsvorsitzender



Robert Leurs
Finanzvorstand



Walter Braun
Produktionsvorstand

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die SÜSS MicroTec SE, Garching

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS

PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben den Konzernabschluss der SÜSS MicroTec SE, Garching, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) — bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, der Konzerngesamtergebnisrechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 sowie dem Konzernanhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den zusammengefassten Lagebericht der SÜSS MicroTec SE für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die unter „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des zusammengefassten Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2017 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 und
- vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der unter „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des zusammengefassten Lageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht zu dienen.

BESONDERS WICHTIGE PRÜFUNGSSACHVERHALTE IN DER PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Wir haben folgende Sachverhalte als besonders wichtige Prüfungssachverhalte identifiziert:

1. Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts im Segment Lithografie
2. Realisation des Lizenzertrags aus einer von SÜSS MicroTec entwickelten Technologie

1. WERTHALTIGKEIT DES GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERTS IM SEGMENT LITHOGRAFIE

Sachverhalt

Im Konzernabschluss der SÜSS MicroTec SE zum 31. Dezember 2017 wird ein Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von insgesamt rd. EUR 15,6 Mio. ausgewiesen, der 7,7 % der Konzernbilanzsumme bzw. 12,3 % des Konzern-Eigenkapitals ausmacht. Dieser Geschäfts- oder Firmenwert wurde der zahlungsmittelgenerierenden Einheit Lithografie zugeordnet, die dem Segment Lithografie entspricht.

Zahlungsmittelgenerierende Einheiten mit Geschäfts- oder Firmenwerten werden mindestens einmal jährlich sowie ergänzend bei Anhaltspunkten für eine Wertminderung von der Gesellschaft einem Werthaltigkeitstest (sog. Impairment Test) unterzogen. Die Bewertung erfolgt dabei mittels eines Bewertungsmodells nach dem sog. Discounted-Cash-Flow-Verfahren. Liegt der Buchwert einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit über dem erzielbaren Betrag, wird in Höhe des Unterschiedsbetrags eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Die Beurteilung der Werthaltigkeit eines Geschäfts- oder Firmenwerts ist komplex und erfordert zahlreiche Schätzungen und Ermessensentscheidungen der gesetzlichen Vertreter, vor allem hinsichtlich der Höhe der zukünftigen Zahlungsmittelüberschüsse, der Wachstumsrate für die Prognose der über den Detailplanungszeitraum hinausgehenden Cashflows und des zu verwendenden Diskontierungszinssatzes. Aufgrund der betragsmäßigen Bedeutung des Geschäfts- oder Firmenwerts für den Konzernabschluss der SÜSS MicroTec SE und den mit der Bewertung verbundenen Unsicherheiten liegt ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt vor.

Die Angaben der SÜSS MicroTec SE zum Geschäfts- oder Firmenwert sind den Abschnitten 2D. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 2E. Verwendung von Schätzungen sowie (12) Geschäfts- oder Firmenwert des Konzernanhangs enthalten.

Prüferische Reaktion und Erkenntnisse

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Angemessenheit der wesentlichen Annahmen und ermessensbehafteten Parameter sowie der Berechnungsmethode der Werthaltigkeitstests unter Einbeziehung unserer Bewertungsspezialisten beurteilt. Wir haben ein Verständnis der Planungssystematik und des Planungsprozesses sowie der wesentlichen von den gesetzlichen Vertretern in der Planung getroffenen Annahmen erlangt. Die Prognose der zukünftigen Zahlungsmittelüberschüsse im Detailplanungszeitraum haben wir mit dem vom Aufsichtsrat genehmigten Budget für das Jahr 2018 sowie Planungen für die beiden Folgejahre 2019 und 2020 abgestimmt und uns anhand einer Analyse von Plan-Ist-Abwei-

chungen in der Vergangenheit von der grundsätzlichen Planungstreue der Gesellschaft überzeugt. Wir haben die der Planung zugrunde liegenden Annahmen und die bei der Prognose der über den Detailplanungszeitraum hinausgehenden Cashflows unterstellten Wachstumsraten durch Abgleich mit vergangenen Entwicklungen und aktuellen branchenspezifischen Markterwartungen nachvollzogen. Darüber hinaus haben wir die verwendeten Diskontierungssätze anhand der durchschnittlichen Kapitalkosten einer Peer Group kritisch hinterfragt.

Insgesamt konnten wir uns davon überzeugen, dass die von den gesetzlichen Vertretern bei der Durchführung des Werthaltigkeitstests getroffenen Annahmen und die verwendeten Bewertungsparameter nachvollziehbar sind und innerhalb einer vertretbaren Bandbreite liegen.

2. REALISATION DES LIZENZERTRAGS AUS EINER VON SÜSS MICROTEC ENTWICKELTEN TECHNOLOGIE

Sachverhalt

Der SÜSS Konzern (SÜSS MicroTec) hat im Geschäftsjahr 2017 ein Lizenzabkommen zur Vermarktung einer von SÜSS MicroTec entwickelten Technologie zum Reinigen von Fotomasken abgeschlossen. Das Lizenzabkommen sieht die Zahlung einer Basis-Lizenzgebühr an SÜSS MicroTec in Höhe von EUR 2,0 Mio. im dritten Quartal 2017 vor. Diese Lizenzgebühr wurde im Konzernabschluss der SÜSS MicroTec SE zum 31. Dezember 2017 nahezu vollständig als Ertrag erfasst.

Die Beurteilung, ob die Lizenzgebühr über die Laufzeit der Vereinbarung zu verteilen oder sofort erfolgswirksam zu vereinnahmen ist, ist komplex. Aus diesem Grund und angesichts der Wesentlichkeit der Auswirkung auf das Konzernergebnis lag aus unserer Sicht ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt vor.

Die Angaben der SÜSS MicroTec SE zur Ertragsrealisierung im Zusammenhang mit der Lizenzvereinbarung sind in den Abschnitten 2D. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und (5) Sonstige betriebliche Erträge des Konzernanhangs enthalten.

Prüferische Reaktion und Erkenntnisse

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir Einsicht in die Lizenzvereinbarung genommen und die relevanten Vertragsinhalte im Hinblick auf ihre Abbildung nach IAS 18 gewürdigt. Dabei haben wir insbesondere die von den gesetzlichen Vertretern getroffene Einschätzung beurteilt, dass die Voraussetzungen für die Klassifizierung als Verkaufstransaktion erfüllt sind und dass für SÜSS MicroTec für den Erhalt der Lizenzgebühr keine weiteren Leistungsverpflichtungen bestehen, die einer sofortigen Ertragsrealisierung im Wege stehen würden.

Insgesamt konnten wir uns davon überzeugen, dass die Realisierung des Ertrags aus der Lizenzvereinbarung im Geschäftsjahr 2017 angemessen war und im Rahmen der relevanten Vorschriften des IAS 18 erfolgte.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen:

- die gesondert veröffentlichte nichtfinanzielle Konzernklärung gemäß dem Verweis im Abschnitt „Nichtfinanzielle Konzernklärung gemäß § 315b HGB“ des zusammengefassten Lageberichts
- die im Abschnitt „Konzernklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f und § 315d HGB“ des zusammengefassten Lageberichts enthaltene Konzernklärung zur Unternehmensführung und
- die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Ausnahme des geprüften Konzernabschlusses und zusammengefassten Lageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum zusammengefassten Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN KONZERNABSCHLUSS UND DEN ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Angaben ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des zusammengefassten Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres- und Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im zusammengefassten Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist, und ob der zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und zusammengefassten Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im zusammengefassten Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im zusammengefassten Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.
- holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.

- beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und über die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

ÜBRIGE ANGABEN GEMÄSS ARTIKEL 10 EU-APRVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 25. August 2017 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 2012 als Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec SE tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den Aufsichtsrat nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Thomas Steiner.

München, den 14. März 2018

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

S. Wiedemann
Wirtschaftsprüfer

T. Steiner
Wirtschaftsprüfer

GLOSSAR

3D-Integration

3D-Integration unterteilt sich in zwei Hauptkategorien: in 3D-Packaging und 3D-Interconnect. 3D-Packaging bezeichnet Bauteile, die auf Wafer-Level-Packaging-Ebene gestapelt werden, ohne durch sogenannte Through-Silicon-Vias (TSV) miteinander verbunden zu sein. Unter 3D-Packaging werden Technologien wie SOC (System-on-a-Chip) sowie weitere Verfahren subsumiert, bei denen die Verbindung üblicherweise auf Wire-Bonding (Drahtbonden) basiert. 3D-Interconnect beinhaltet dagegen Bauteile, die durch Through-Silicon-Vias (TSV) verbunden sind. Dabei handelt es sich um vertikale Durchkontaktierungen durch das in der Regel stark gedünnte massive Silizium.

300-mm-Technologie

Wafer sind runde Scheiben z.B. aus einkristallinem Reinst-Silizium, das als Grundmaterial für die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergrößte Teil (etwa 42%) der heute weltweit verwendeten Siliziumscheiben hat einen Durchmesser von 300mm. Je größer der Durchmesser des Wafers, umso größer ist auch die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können. Je höher die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können, desto geringer sind die Produktionskosten pro einzelnen Chip.

Advanced Packaging

Mit dem Begriff „Packaging“ wird die Technologie des „Verpackens“ von Mikrochips in Gehäuse bezeichnet. Dabei müssen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf die Außenseite des Gehäuses geführt werden, um dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewährleisten. Unter Advanced Packaging versteht man weiterentwickelte Packaging-Verfahren, die in der Regel Methoden einsetzen, die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im sogenannten Frontend der Chipfertigung, eingesetzt wurden. Als Beispiel können hier Lithografie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

Backend

Backend bezeichnet den zweiten (hinteren) Teil der Fertigungskette in der Mikrochip-Fertigung. Nachdem der Wafer sämtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen Mikrochips durchlaufen hat (Frontend), beginnt der Backend-Prozess. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und ggf. für das Bonden vorbereitet. Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersägt und diese werden in Gehäuse „verpackt“. Aus Kostengründen findet der Backend-Prozess überwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller eigene Backend-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen (Foundries) durchführen lassen.

Belacker (Beschichtungsgerät)

Belacker sind Spezialmaschinen für die Halbleiterfertigung, die einen fotoempfindlichen Lack mittels Rotationskraft auf dem Wafer verteilen.

Bonden

Mit dem Begriff „Bonden“ bezeichnet man das Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafern mit Hilfe verschiedener chemischer und physikalischer Effekte, z.B. bedeutet „adhäsives Bonden“ das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze oder Fotoresist); „Fusion-Bond“ oder „Direct Bond“ ist das direkte Verbinden zweier Wafer, die zunächst nur durch die schwachen atomaren Kräfte von Wassermolekülen in der Grenzschicht (Van-der-Waals-Kräfte) miteinander verbunden werden. Durch ein anschließendes Ausheizen werden die Wassermoleküle aufgebrochen und die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid (kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nichtlösbare Verbindung der beiden Wafer dar.

Bump

(engl.: Unebenheit); metallische (Lot, Gold o. Ä.), dreidimensionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkugeln auf einem einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

Chip

Allgemeiner Begriff für Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehäuse eingebettet ist. Von außen sieht man in der Regel nur das schwarze Gehäuse und die Anschlussstellen, mit denen der Chip mit der Leiterplatte verbunden wird (durch Wire-Bonding oder Flip-Chip-Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird häufig aber auch nur das Stück Silizium bezeichnet, das im Gehäuse sitzt.

Cluster

Eine Gerätegruppe von einzelnen Prozessmodulen (z.B. Belacker, Aligner), die von einem zentral angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafern bestückt wird.

Compound-Semiconductor

Siehe Verbindungshalbleiter.

Cost-of-Ownership

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser ist die Cost-of-Ownership der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende Cost-of-Ownership ist besonders im Rahmen der Massenproduktion von großer Bedeutung.

Die

„Die“, IC (Integrated Circuit) und Chip sind oft synonym verwendete Begriffe. „Dies“ heißen die ICs, solange sie noch nicht in das Gehäuse integriert wurden. Solange der Wafer also die einzelnen Prozessschritte durchläuft, spricht man von „Dies“. Erst nach dem Vereinzeln und Verpacken der „Dies“ spricht man von Chips.

DRAM

DRAM steht für „Dynamic Random Access Memory“. Elektronischer Speicherbaustein, der hauptsächlich in Computern eingesetzt wird.

Fab

(engl.: Fabrik); Fabriken, die sich auf die Produktion von ICs auf Wafern (Chips) spezialisiert haben. Die Errichtung einer großen, modernen Fab mit den erforderlichen Reinräumen und Maschinen (Equipment) kostet heute ca. 1,5 bis 4 Mrd. USD.

Flip-Chip-Bonding

Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehäuse, die höhere Taktfrequenzen bei der Signalübertragung ermöglicht. Die aktive Chipseite zeigt dabei nach unten, d.h., der Chip muss vor der Montage umgedreht (engl.: to flip) werden.

Fotoresist

Lichtempfindliches Material, das zunächst als Schicht auf den Wafer aufgetragen und dann mit Hilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische Veränderungen erzeugt. Diese Teilbereiche werden während der Entwicklung aus der Schicht herausgelöst, so dass eine reliefartige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Fotografie sehr ähnlich.

Foundry

Foundry ist eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich somit um eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten für das Chipdesign sowie für den Vertrieb und das Marketing ihrer Produkte entstehen, können sie ihre Forschung und Entwicklung für Ressourcen vollständig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die weltweit führenden Foundries sind in Taiwan und Singapur angesiedelt.

Frontend

Frontend-Prozesse sind sämtliche Produktionsschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Hier wird der Chip an sich hergestellt. Danach schließt sich das Backend an. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und der Wafer anschließend in die einzelnen Chips zersägt, die dann mit einem Gehäuse versehen werden.

Halbleiter

Ein kristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch ICs aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

IC (Integrated Circuit)

Ein Integrated Circuit ist ein integrierter Schaltkreis und besteht aus elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, die auf engstem Raum in einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele 10 Millionen solcher Zellen in einen Chip integriert und miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte von Mikrochips hat zu einer enormen Leistungsfähigkeit der Chips geführt.

IDM (Integrated-Device-Manufacturer)

Hierbei handelt es sich um Unternehmen in der Halbleiterbranche, die Halbleiterbauteile selbst entwickeln, produzieren und vermarkten.

Laser-Prozessierung

Neue Entwicklungen in der Festkörper-Laser-Technologie, wie z.B. die hochleistungsfähigen UV-Laser mit hohen Pulsraten in Piko-sekunden, haben die Anwendungsmöglichkeiten für Laser um die Mikrostrukturierung erweitert. SÜSS MicroTec bietet zwei Laser-Technologien an:

Excimer-Laserabdampfung: In der Mikrostrukturierung bietet der Einsatz von Excimer-Laser vor allem Möglichkeiten für eine Materialabdampfung. Durch Beschuss mit gepulster Laserstrahlung lässt sich Material von einer Oberfläche abtragen. Dabei stößt eine fotochemische Reaktion eine Elektronenanregung an, die in einem plötzlichen Druckanstieg und einer explosiven Abtragung von Material in Form von Monomeren und Gasen resultiert. Die thermische Wirkung ist hierbei minimal – die Prozesstechnologie schont temperaturempfindliche Materialien. Die Systeme verwenden eine Fotomaske, die mit einem Laserstrahl beleuchtet wird. Eine Projektionsoptik zwischen Maske und Wafer bildet, ähnlich einem Projektionsstepper in der Lithografie, die Maskenstrukturen auf dem Wafer ab. Jedoch wird das Material nicht belichtet, sondern direkt abgetragen. Mit einem Step-and-repeat-Verfahren wird der komplette Wafer strukturiert.

Prozessierung mit Festkörper-Laser: Die Festkörper-Laser-Technologie verspricht alle Vorteile der Laser-Prozessierung: Sie erreicht hohe Auflösungen von bis zu zwei Mikrometern und sorgt für besonders präzise Ergebnisse. Strukturierungsprozesse laufen ohne thermische Nebenwirkungen ab. Die Systeme kommen ohne Maske aus und verwenden eine direkte Schreibmethode.

LED (Light Emitting Diode)

Leuchtdioden sind Halbleiterbauteile, die Licht erzeugen können. LEDs leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darüber hinaus haben sie eine mehr als zehnmals so große Lebensdauer wie eine normale Glühbirne.

Lithografie

Die elektrischen Schaltkreise der ICs werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Siliziumwafer in einer Art Schichten-aufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Strukturen auf der Maske werden so mittels Schattenwurf auf den Wafer aufgebracht. An Stellen, an denen die Maske lichtundurchlässig ist, wird der Fotoresist auf dem Wafer nicht belichtet. An lichtdurchlässigen Stellen der Maske fällt Licht auf den Wafer und der Fotoresist wird belichtet. Während der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen des Fotoresists, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus der Schicht herausgelöst und der Wafer wird an diesen Stellen freigelegt. Typische Strukturgrößen für Lithografieanwendungen im Frontend liegen heute in einer Größenordnung von 32nm (0,032µm) bis 0,6µm. Im Backend werden Strukturgrößen von einigen Mikrometern bis einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt, z.B. um die Bumps für das Flip-Chip-Bonding herzustellen.

Maske

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines IC benötigt werden; die Muster bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der Größe und Form der gewünschten Schaltkreise.

Mask-Aligner (Belichtungsgerät)

Mask-Aligner richten eine Glasmasken submikrometergenau zu einem Wafer aus. Das mikroskopische Bild auf der Glasmasken wird mittels Belichtung auf den belackten Wafer übertragen.

MEMS (Micro Electro Mechanical System)

MEMS steht für „Micro Electro Mechanical System“ und ist der vor allem in Nordamerika verwendete Begriff für die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebräuchlicher). Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektronische Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Automobilindustrie, der Telekommunikation, der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

Mikrometer/Mikron

Metrisches Längenmaß; Zeichen: µm. Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt ca. 60µm.

Mikrosystem

Ein aus verschiedenen Bauteilen, die in der Dimension unterhalb eines Millimeters liegen, zusammengesetztes System.

Mikrosystemtechnik

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definitionen des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden. In den USA und Asien bedeutet „Micro System Technology“ oder der häufiger verwendete Begriff „Micro Electro Mechanical System“ (MEMS) den Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder aber auch komplexer Systeme, wie z.B. einer kompletten chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z.B. der Beschleunigungssensor aus Silizium, der zum Auslösen des Airbags eingesetzt wird, oder aber die Düse in der Patrone des Tintenstrahldruckers.

Nanoimprinting/Nano-Imprint-Lithografie (NIL)

Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder dreidimensionale Strukturen im Nanometerbereich mit einem Abformwerkzeug oder Stempel hergestellt werden. Im Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von Schaltungen auf Halbleiter-Wafern werden die Strukturen durch „Stempeln“ in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man erhofft sich vom Nanoimprinten in der Zukunft einen Preisvorteil, weil die Fortsetzung der Fotolithografie in Richtung höchste Auflösung extrem kurze Wellenlängen der Lichtstrahlung (EUV, Röntgen) benötigen wird und das entsprechende Equipment unangemessen teuer zu werden droht.

Nanotechnologie

Sammelbegriff für eine breite Auswahl von Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im Größenbereich von einem bis mehrere hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter (10^{-9}m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die typischen Abmessungen von einzelnen Molekülen liegen. Nanotechnologie ist eine konsequente Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist völlig unkonventionellen neuen Ansätzen: Die Nanotechnologie beschäftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen im Nanometerbereich zu schaffen.

Optoelektronik

Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halbleiterelektronik mit sogenannten III/V-Materialien wie z.B. Galliumarsenid kann Licht erzeugt oder detektiert werden (Halbleiter-Laser, LED, Fotodioden etc.). Diese Technologie wird hauptsächlich in der Telekommunikation für die Übertragung sehr großer Datenmengen (faseroptische Netze) eingesetzt. Allerdings finden LEDs wegen ihrer vielen Vorteile, wie des geringen Energiebedarfs, der sehr hohen Helligkeit und der sehr langen Lebensdauer, zunehmend Verwendung im Automobilbau und im Haushalt.

OSAT (Outsourced Assembly- and Test-Houses)

Diese Unternehmen sind im Mid- und Backend der Halbleiterindustrie angesiedelt. Sie offerieren Packaging-Lösungen, Testsysteme und weitere Serviceleistungen für Halbleiterhersteller, ohne dabei an einen bestimmten Hersteller gebunden zu sein. Schwerpunkt ist häufig das Packaging und Assembly von ICs und anderen Halbleiterprodukten.

Packaging-Foundries

Siehe Backend.

Projektionslithografie

Während bei der Vollfeldlithografie (Mask-Alignern) der komplette Wafer in einem Vorgang belichtet wird, werden bei projektlithografischen Prozessen typischerweise nur einzelne Bereiche des Wafers unter Verwendung einer Projektionsoptik belichtet. Die komplette Belichtung des Wafers wird dann entweder schrittweise (Step and repeat) oder kontinuierlich (Scan) durchgeführt. SÜSS MicroTec fertigt 1:1-Projektionsscanner für das Halbleiter-Mid- und -Backend. Hierbei wird eine Vollfeldmaske verwendet und der Wafer in einem Scannvorgang belichtet. Eine Verkleinerung der Strukturgrößen von der Maske zum Wafer findet nicht statt. Die Projektionsscanner-Technologie von SÜSS MicroTec kombiniert Vorteile der Vollfeldbelichtung mit denen der klassischen Projektionslithografie und bietet eine Alternative zu Mask-Alignern und Projektionssteppern.

Sensor

Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von Messgrößen wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung; diese Größe wird in ein elektrisches Signal gewandelt und an eine Signalauswertungseinheit weitergegeben.

Silizium

Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halbleitenden Eigenschaften; halbleitend bedeutet, dass je nach Einbau von bestimmten Fremdatomen der Werkstoff als elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet werden kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von Scheiben eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff verwendet.

Substrat-Bonder (Verbindungsgerät)

Ein Bonder verbindet zwei oder mehr äußerst präzise zueinander ausgerichtete Substrate, meist Wafer, durch Löten, Kleben oder andere physikalisch-chemische Verfahren miteinander. Viele MEMS-Bausteine benötigen diesen Prozessschritt. Erst dann können Airbags, Reifendrucksensoren, GPS-Sensoren, Tintenstrahldrucker etc. funktionieren.

System-on-a-Chip

Hochkomplexe ICs, die viele verschiedene Funktionen enthalten; bis vor Kurzem musste man diese noch auf mehreren ICs unterbringen. Die gewaltige Innovationskraft in der Prozesstechnik, die die Fertigung von ICs mit immer kleineren Strukturbreiten erlaubt, ermöglicht heute, dass auf einem Chip verschiedene Sorten von Speichern, digitale Signalprozessoren und analoge Funktionen untergebracht werden können. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler Chips nur noch sehr wenige oder ein einzelner erforderlich ist und sich so der Platzbedarf, der Montageaufwand (und damit die Kosten des Endprodukts) und, was sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern. In batteriebetriebenen Geräten (Notebooks, Handys) verlängert sich so die Lebensdauer der Batterien. Der Trend zu immer kleineren und mobilen Geräten, die zudem immer günstiger werden sollen, verleiht System-on-a-Chip immer größere Bedeutung.

Through-Silicon-Via (TSV)

Bei der Through-Silicon-Via-Technik werden die einzelnen Chipkomponenten übereinandergestapelt und mittels vertikaler Durchkontaktierungen (Through-Silicon-Vias) miteinander verbunden. Dadurch verkürzt sich der Weg des Datenstroms zwischen den einzelnen Chipkomponenten, so lassen sich Kapazitätsverluste wesentlich reduzieren. Through-Silicon-Vias tragen somit zu einer Verringerung der Baugröße von Chips bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit bei.

Tool

Maschine, Werkzeug, Roboter usw.; Tools sind alle Einzelsysteme, die in einer Halbleiterfabrik zu einer Produktionslinie kombiniert werden.

Verbindungshalbleiter

Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen (Galliumarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium etc.); Vorteile gegenüber einfachen Elementhalbleitern: Verbindungshalbleiter sind besonders schnell, können auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrauchen trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

Wafer

Runde Scheiben z.B. aus Reinst-Silizium oder Verbindungshalbleitern (Galliumarsenid, Indiumphosphid etc.), aus denen Chips produziert werden; in den letzten zehn Jahren hat sich der Durchmesser von 150 über 200 auf heute sogar 300mm vergrößert. Auf die Grundfläche der neuesten 300-mm-Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen 200-mm-Wafer – die Produktionskosten sind dadurch ca. 30% niedriger.

Wire-Bonding

Gängiges Kontaktverfahren, um Chips über Metalldrähte mit einem Gehäuse zu verbinden.

Yield

Die Ausbeute ist eine der wesentlichen Kenngrößen in der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je höher der Yield, desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden.

IMPRESSUM

Herausgeber ————— SÜSS MicroTec SE
Redaktion ————— Finance: Julia Natterer
Investor Relations: Franka Schielke
Wirtschaftsprüfer ————— BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Konzept und Gestaltung — wagneralliance Kommunikation GmbH, Offenbach
Druck ————— Eberl Print GmbH, Immenstadt
Fotos ————— SÜSS MicroTec SE, Garching
Marek Vogel, München
Ed Carreon Photography, Los Angeles
Creativ Fotostudio Allan Richard Tobis, München

KONTAKT

SÜSS MicroTec SE
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Telefon: +49 89 32007-0
E-Mail: info@suss.com

Investor Relations
Telefon: +49 89 32007-161
E-Mail: ir@suss.com
www.suss.com

Zukunftsorientierte Aussagen: Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec SE. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.

FÜNFJAHRESÜBERSICHT

<i>in Mio. €</i>	2017	2016	2015	2014	2013
Geschäftsentwicklung					
Auftragseingang	200,3	161,1	188,6	134,3	135,0
Auftragsbestand zum 31.12.	133,4	101,5	117,6	75,6	85,7
Umsatz gesamt	166,5	177,6	148,5	145,3	134,5
Umsatzrendite	4,0%	2,8%	0,1%	3,2%	-11,9%
Rohertrag	59,5	58,6	49,4	48,8	21,8
Rohertragsmarge	35,7%	33,0%	33,3%	33,6%	16,2%
Herstellungskosten	107,0	119,0	99,2	96,5	112,7
Forschungs- und Entwicklungskosten	15,2	14,1	12,8	10,5	10,2
EBITDA	18,0	15,3	9,2	12,6	-13,4
EBITDA-Marge	10,8%	8,6%	6,2%	8,7%	-10,0%
EBIT	13,9	11,1	5,0	8,4	-19,4
EBIT-Marge	8,3%	6,3%	3,4%	5,8%	-14,4%
Ergebnis nach Steuern	6,7	5,0	0,2	4,6	-16,0
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)	0,35	0,26	0,01	0,24	-0,84
Bilanz und Cashflow					
Eigenkapital	127,0	124,4	118,7	116,1	109,4
Eigenkapitalquote	62,9%	69,2%	67,0%	69,1%	60,8%
Eigenkapitalrentabilität	5,3%	4,0%	0,2%	4,0%	-14,6%
Bilanzsumme	202,0	179,6	177,2	168,0	179,9
Net Cash	33,0	31,1	40,0	38,0	35,7
Free Cashflow	2,9	-9,1	1,3	2,1	4,1
Weitere Kennzahlen					
Investitionen	6,5	3,6	3,4	3,0	12,2
Investitionsquote	3,9%	2,0%	2,3%	2,1%	9,1%
Abschreibungen	4,1	4,2	4,2	4,2	6,0
Mitarbeiter zum 31.12.	779	711	698	659	655

FINANZKALENDER 2018

- 27. März** ——— Geschäftsbericht 2017
- 03. Mai** ——— Quartalsbericht 2018
- 06. Juni** ——— Hauptversammlung 2018, Haus der Bayerischen Wirtschaft, München
- 03. Aug** ——— Halbjahresfinanzbericht 2018
- 07. Nov** ——— Neunmonatsbericht 2018

SÜSS MicroTec SE

Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Telefon: +49 89 32007-0
E-Mail: info@suss.com